輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令（第一編）
Ministerial Order Specifying Goods and Technologies Pursuant to the Provisions of the Appended Table 1 of the Export Trade Control Order and the Appended Table of the Foreign Exchange Order (Part 1)

（平成三年十一月十四日通商産業省令第四十九号）

(Order of the Ministry of International Trade and Industry of No. 49 of November 14, 1991)

輸出貿易管理令（昭和二十四年政令第三百七十八号）別表第一及び外国為替管理令（昭和五十五年政令第二百六十号）別表の規定に基づき、輸出貿易管理令別表第一及び外国為替管理令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令を次のように制定する。

This Ministerial Order specifying goods and technologies pursuant to the provisions of the Appended Table 1 of the Export Trade Control Order and the Appended Table of the Foreign Exchange Control Order is enacted as stated below, pursuant to the provisions of the Export Trade Control Order (Cabinet Order No. 378, 1949) and the Appended Table of the Foreign Exchange Control Order (Cabinet Order No. 260, 1980).

（輸出貿易管理令別表第一関係）

(Re: Appended Table 1 of the Export Trade Control Order)

第一条　輸出貿易管理令（以下「輸出令」という。）別表第一の二の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 1　The goods with specifications prescribed by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 2 of the Appended Table 1 of the Export Trade Control Order (referred to below as the "Export Order") are those that fall under any of the following items:

一　核燃料物質又は核原料物質であって、次のいずれかに該当するもの

(i) nuclear fuel materials or nuclear source materials falling under any of the following sub-items:

イ　ウラン又はその化合物

(a) uranium or uranium compounds;

ロ　トリウム又はその化合物

(b) thorium or thorium compounds;

ハ　プルトニウム又はその化合物

(c) plutonium or plutonium compounds; or

ニ　イからハまでの貨物の一又は二以上を含むもの

(d) nuclear fuel materials or nuclear source materials including one or two or more of the goods referred to in sub-items (a) through (c);

二　原子炉若しくはその部分品若しくは又は車両、船舶、航空機若しくは宇宙空間用若しくは打ち上げ用の飛しょう体の原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置

(ii) power-generating equipment or propulsion equipment designed to be used for nuclear reactors or their components, vehicles, vessels, aircraft or for use in space, or for nuclear reactors of flying objects for launches;

三　重水素又は重水素化合物であって、重水素の原子数の水素の原子数に対する比率が五、〇〇〇分の一を超えるもの

(iii) deuterium or deuterium compounds for which the ratio of the number of atoms of hydrogen to the number of atoms of deuterium exceeds 1/5,000;

四　一キログラム以上の人造黒鉛であって、ほう素当量が全重量の一、〇〇〇、〇〇〇分の五未満で、かつ、二〇度の温度における見掛け比重が一・五〇を超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの

(iv) among artificial graphites weighing 1 kilogram or more with a boron content level less than 5/1,000,000 of the total weight, and, with the apparent specific gravity at 20 degrees centigrade exceeding 1.50, those falling under any of the following sub-items:

イ　原子炉用のもの

(a) those for nuclear reactors; or

ロ　原子炉用に用いることができるもの（イに該当するものを除く。）

(b) those usable in nuclear reactors (excluding those falling under sub-item (a));

五　放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置

(v) devices designed for the separation or reprocessing of irradiated nuclear fuel materials or nuclear source materials, or their components or a control device;

六　リチウムの同位元素の分離用の装置又は核燃料物質の成型加工用の装置

(vi) devices for the separation of lithium isotopes, or devices for the mold processing of nuclear fuel materials;

七　ウラン若しくはプルトニウムの同位元素の分離用の装置であって、次のいずれかに該当するもの若しくはその附属装置又はこれらの部分品

(vii) devices for the separation of uranium or plutonium isotopes falling under any of the following devices or their auxiliary equipment or components of auxiliary equipment:

イ　ガス拡散法を用いるもの

(a) those that use gas diffusion methods;

ロ　遠心分離法を用いるもの

(b) those that use centrifuge separation methods;

ハ　ノズル分離法を用いるもの

(c) those that use nozzle separation methods;

ニ　ボルテックス法を用いるもの

(d) those that use vortex methods;

ホ　化学交換法を用いるもの

(e) those that use chemical exchange methods;

ヘ　レーザー分離法を用いるもの

(f) those that use laser separation methods;

ト　プラズマ法を用いるもの

(g) those that use plasma methods; or

チ　電磁分離法を用いるもの

(h) those that use magnetic separation methods;

八　周波数変換器又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(viii) frequency changers or their components falling under any of the following sub-items:

イ　ガス遠心分離機用の周波数変換器であって、次の（一）及び（二）に該当するもの又はその部分品

(a) frequency changers for gas centrifuges that fall under the following clauses 1. and 2., or their components:

（一）　出力が三相以上のものであって、周波数が六〇〇ヘルツ以上のもの

1. frequency changers with an output of 3 or more phases and a frequency of 600 hertz or more;

（二）　出力周波数をプラスマイナス〇・二パーセント未満で制御できるもの

2. frequency changers capable of controlling output frequency with an accuracy of less than plus or minus 0.2%;

ロ　可変周波数又は固定周波数モーター駆動に用いることができる周波数変換器であって、次の（一）から（三）までの全てに該当するもの（イに該当するもの及び産業機械又は消費財用の周波数変換器であって、当該機械等から取り外した場合には、ハードウェア及びソフトウェアの制限により次の（一）から（三）までのいずれかの特性を満たさなくなるものを除く。）

(b) frequency changers that can be used for variable or fixed frequency motor driving, which fall under all of the following clauses 1. through 3. (excluding those that fall under sub-item (a) and those used for industrial machinery or consumer goods that become unable to satisfy any of the properties specified in the following clauses 1. through 3. due to restrictions on hardware or software):

（一）　出力が三相以上のものであって、四〇ボルトアンペア以上の出力を得ることができるもの

1. an output of three or more phases capable of yielding an output of 40 volt-amperes or more;

（二）　六〇〇ヘルツ以上の出力周波数で作動するもの

2. those that operate with an output frequency of 600 hertz or more; or

（三）　出力周波数をプラスマイナス〇・二パーセント未満で制御できるもの

3. those capable of controlling output frequency with an accuracy of less than plus or minus 0.2%;

九　ニッケルの粉であって、径の平均値が一〇マイクロメートル未満で、かつ、重量比による純度が九九パーセント以上のもの又はこれを用いて製造した多孔質金属

(ix) nickel powders with a mean value of the diameter of less than 10 micrometers, and, a weight-based purity level of 99% or more, or porous metals produced by using nickel powders;

十　重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するもの

(x) devices used for the production of deuterium or deuterium compounds, or their components or auxiliary equipment that falls under any of the following devices:

イ　重水素若しくは重水素化合物の製造用の装置（濃縮用の装置を含む。）又はその部分品若しくは附属装置

(a) those for the production of deuterium or deuterium compounds (including concentration equipment), or their components or auxiliary equipment; or

ロ　重水の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するもの（イに該当するものを除く。）

(b) those used for the production of heavy water or their components or auxiliary equipment, which fall under any of the following clauses (excluding those falling under clause (a)):

（一）　削除

1. Deleted

（二）　低温で用いられる蒸留塔であって、次の１から４までのすべてに該当するもの

2. distillation columns used at low temperatures which fall under all of the following i. through iv.:

１　細粒ステンレス綱であって、水素ぜい性のないものを用いたもの

i. distillation columns that use fine-grain stainless steel without hydrogen embrittlement;

２　内径が三〇センチメートル以上であり、かつ、有効長が四メートル以上のもの

ii. distillation columns with an internal diameter of 30 centimeters or more and an effective length of 4 meters or more;

３　温度が零下二三八度以下で用いることができるように設計したもの

iii. distillation columns designed to be usable at -238 degrees centigrade or less; and

４　〇・五メガパスカル以上五メガパスカル以下の圧力範囲において用いること

ができるように設計したもの

iv. distillation columns designed to be usable within a pressure range of 0.5 megapascals or more and 5 megapascals or less;

（三）　真空蒸留用の塔に用いることができるように設計した充てん物であって、化学的にぬれ性を改善する処理を行った燐青銅製のもののうち、メッシュ状のもの

3. among filling materials designed to be usable in a vacuum distillation column made of phosphorus bronze which has undergone a process that chemically improves wettability, those which are mesh-shaped;

（四）　温度が零下二三八度以下で用いることができるように設計したターボエキスパンダであって、水素の排出量が一時間につき一、〇〇〇キログラム以上のもの

4. turboexpanders designed to be usable at -238 degrees centigrade or less, with a hydrogen emission level of 1,000 kilograms or more per hour;

（五）　削除

5. Deleted

（六）　カリウムアミドを含む液化アンモニアを循環させることができるポンプであって、次の１から３までのすべてに該当するもの

6. pumps capable of circulating liquefied ammonia containing potassium amide, which fall under all of the following clauses i. through iii.:

１　気密な構造のもの

i. pumps with a sealed structure;

２　一・五メガパスカル以上六〇メガパスカル以下の圧力範囲において用いることができるもの

ii. pumps usable within a pressure range of 1.5 megapascals or more and 60 megapascals or less;

３　吐出し量が一時間につき八・五立方メートルを超えるもの

iii. pumps with discharge quantity exceeding 8.5 cubic meters per hour;

十の二　三酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二酸化ウラン、四ふっ化ウラン、金属ウラン若しくは四塩化ウランの製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの若しくはその附属装置又はこれらの部分品

(x)-2 devices for the production of uranium trioxide, uranium hexafluoride, uranium dioxide, uranium tetrafluoride, metallic uranium, or uranium tetrachloride, which fall under any of the following devices, or their auxiliary equipment or components:

イ　ウラン精鉱を原料とする三酸化ウランの製造用の装置

(a) devices used for the production of uranium trioxide whose raw material is uranium concentrate;

ロ　三酸化ウラン又は四ふっ化ウランを原料とする六ふっ化ウランの製造用の装置

(b) devices used for the production of uranium hexafluoride whose raw material is uranium trioxide or uranium tetrafluoride;

ハ　三酸化ウラン又は六ふっ化ウランを原料とする二酸化ウランの製造用の装置

(c) devices used for the production of uranium dioxide whose raw material is uranium trioxide or uranium hexafluoride;

ニ　二酸化ウラン又は六ふっ化ウランを原料とする四ふっ化ウランの製造用の装置

(d) devices used for the production of uranium tetrafluoride whose raw material is uranium dioxide or uranium hexafluoride;

ホ　四ふっ化ウランを原料とする金属ウランの製造用の装置

(e) devices used for the production of metallic uranium whose raw material is uranium tetrafluoride;

ヘ　二酸化ウランを原料とする四塩化ウランの製造用の装置

(f) devices used for the production of uranium tetrachloride whose raw material is uranium dioxide;

十の三　二酸化プルトニウム、しゅう酸プルトニウム、過酸化プルトニウム、三ふっ化プルトニウム、四ふっ化プルトニウム若しくは金属プルトニウムの製造用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品

(x)-3 devices used for the production of plutonium dioxide, plutonium oxalate, plutonium peroxide, plutonium trifluoride, plutonium tetrafluoride, or metallic plutonium, or their auxiliary equipment or components;

十一　しごきスピニング加工機又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(xi) flow-forming machines or their components which fall under either of the following sub-items:

イ　しごきスピニング加工機であって、数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもののうち、ローラの数が三以上のもの

(a) among shear spinning machines capable of being controlled by a numerical control equipment or computer, those with three or more rollers;

ロ　内径が七五ミリメートル超四〇〇ミリメートル未満の円筒形のロータを成形することができるように設計したマンドレル

(b) mandrels designed to be capable of forming cylindrical rotors with an internal diameter exceeding 75 millimeters and less than 400 millimeters;

十二　削除

(xii) Deleted

十三　削除

(xiii) Deleted

十四　工作機械（金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。）であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上の電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイからニまでのいずれかに該当するもの（ホに該当するものを除く。）

(xiv) among machine tools (limited to those capable of processing metals, ceramics, or composite materials) to which an electronic control device with two or more axes capable of controlling contour can be attached, those falling

under any of the following sub-items (a) through (d):

イ　旋削をすることができる工作機械であって、次の（一）及び（二）に該当するもの（（三）に該当するものを除く。）

(a) machine tools capable of lathe turning, which fall under the following clauses 1. and 2. (excluding those falling under clause 3.):

（一）　国際標準化機構が定めた規格（以下「国際規格」という。）ＩＳＯ二三〇／二（一九八八）で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇六ミリメートル未満のもの

1. those whose precision of positioning of the rectilinear axis is 0.006 millimeters or less when measured by the measurement method specified by the International Standards Organization (referred to as "International Standard" below) ISO 230-2:1988;

（二）　直径が三五ミリメートルを超えるものを加工することができるもの

2. those capable of processing objects with a diameter exceeding 35 millimeters;

（三）　棒材作業用の旋盤のうち、スピンドル貫通穴から材料を差し込み加工するものであって、次の１及び２に該当するもの

3. among lathes for bar work that processes materials by inserting them from a spindle hole, which fall under the following clauses i. and ii.:

１　加工できる材料の最大直径が四二ミリメートル以下のもの

i. those capable of processing materials with the maximum diameter of 42 millimeters or less;

２　チャックを取り付けることができないもの

ii. those incapable of attaching a chuck;

ロ　フライス削りをすることができる工作機械であって、次の（一）から（三）までのいずれかに該当するもの（（四）に該当するものを除く。）

(b) machine tools capable of millworking, which fall under any of the following clauses 1. through 3. (excluding those falling under 4.):

（一）　国際規格ＩＳＯ二三〇／二（一九八八）で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇六ミリメートル未満のもの

1. those whose precision of positioning of the rectilinear axis is 0.006 millimeters or less when measuring the full length of the straight axis by the measurement method specified by the International Standard ISO 230-2:1998;

（二）　輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの

2. those with two or more rotational axes capable of controlling contour;

（三）　輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの

3. those with five or more axes capable of controlling contour;

（四）　フライス盤であって、次の１及び２に該当するもの

4. milling machines that fall under the following clauses i. and ii.:

１　国際規格ＩＳＯ八四一（数値制御工作機械―座標軸及び運動の記号）で定めるＸ軸の方向の移動量が二メートルを超えるもの

i. those whose movement amount in the X-axis direction specified by the International Standard ISO 841 (numerical control machine tools – coordinate axis and motion symbols) exceeds 2 meters;

２　国際規格ＩＳＯ二三〇／二（一九八八）で定める測定方法により国際規格ＩＳＯ八四一で定めるＸ軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇三ミリメートルを超えるもの

ii. those whose precision of positioning exceeds 0.03 millimeters when measuring the full length of of the X-axis specified by the International Standard ISO 841 by the measurement method specified by International Standard ISO 230-2:1998;

ハ　研削をすることができる工作機械であって、次の（一）から（三）までのいずれかに該当するもの（次の（四）又は（五）に該当するものを除く。）

(c) machine tools capable of grinding, which fall under any of the following clauses 1. through 3. (excluding those falling under clause 4. or 5.):

（一）　国際規格ＩＳＯ二三〇／二（一九八八）で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇四ミリメートル未満のもの

1. those whose precision of positioning is 0.004 millimeters or less when measuring the full length of of the linear axis by the measurement method specified by the International Standard ISO 230-2:1998;

（二）　輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの

2. those with two or more rotational axes capable of controlling contour;

（三）　輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの

3. those with five or more axes capable of controlling contour;

（四）　円筒外面研削盤、円筒内面研削盤又は円筒内外面研削盤であって、次の１及び２に該当するもの

4. an external cylindrical grinding machine, an internal cylindrical grinding machine, or an external and internal cylindrical grinding machine, which falls under the following clauses i. and ii.:

１　外径又は長さが一五〇ミリメートル以内のものを研削するように設計したもの

i. those designed to grind objects with an external diameter or length of 150 millimeters or less;

２　国際規格ＩＳＯ八四一で定めるＸ軸、Ｚ軸及びＣ軸のみを有するもの

ii.those that possess only an X-axis, a Z-axis, and a C-axis specified by the International Stqandard ISO 841;

（五）　ジグ研削盤であって、次の１及び２のいずれにも該当しないもの

5. jig grinding machines that do not fall under either of the following clause i. or ii.:

１　国際規格ＩＳＯ八四一で定めるＺ軸を有するもののうち、国際規格ＩＳＯ二三〇／二（一九八八）で定める測定方法により当該Ｚ軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇四ミリメートル未満のもの

i. among those possessing a Z-axis specified by the International Standard ISO 841, those whose precision of positioning is less than 0.004 millimeters when measuring the full length of the Z-axis by the measurement method specified by International Standard ISO 230-2:1998;

２　国際規格ＩＳＯ八四一で定めるW軸を有するもののうち、国際規格ＩＳＯ二三〇／二（一九八八）で定める測定方法により当該W軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇四ミリメートル未満のもの

ii. among those possessing a W-axis specified by the International Standard ISO 841, those whose precision of positioning is less than 0.004 millimeters when the full length of the W-axis is measured by the measurement method specified by International Standard ISO 230-2:1998;

ニ　放電加工（ワイヤ放電加工を除く。）をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの

(d) machine tools capable of performing electrical discharge machining (excluding wire electrical discharge machining), with two or more rotational axes capable of contour control;

ホ　工作機械であって、次のいずれかを製造するためのみに設計したもの

(e) machine tools designed only for the production of any of the following things:

（一）　歯車

1. gears;

（二）　クランク軸又はカム軸

2. crank shafts or cam shafts;

（三）　工具又は刃物

3. tools or blades;

（四）　押出機のウオーム

4. extruder worms;

十五　削除

(xv) Deleted

十六　削除

(xvi) Deleted

十七　測定装置（工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。）であって、次のいずれかに該当するもの（第十四号に該当するものを除く。）

(xvii) measuring equipment (including machine tools usable as a measuring equipment) that falls under any of the following equipment (excluding those falling under item (xiv)):

イ　電子計算機又は数値制御装置により制御される測定装置であって、次のいずれ

かに該当するもの

(a) measuring equipment controlled by a computer or numerical control equipment, which falls under any of the following equipment:

（一）　測定軸の数が二であって、国際規格で定める測定方法によりそれぞれの軸の測定精度を測定した場合に、操作範囲内のいずれかの測定点において、測定軸のマイクロメートルで表した最大許容長さ測定誤差の数値がミリメートルで表した当該測定軸の長さに〇・〇〇一を乗じて得た数値に一・二五を加えた数値以下となるもの

1. those with two or more measurement axes, and when the measurement accuracy of each axis is measured using the measurement method specified by the International Standard, at any of the measuring points within the operating range, the numerical value of the maximum permissible error for the length of the measurement axis measured expressed in micrometers is less than the numerical value to which 1.25 is added to the numerical value obtained by multiplying the length of the measurement axis expressed in millimeters by 0.001;

（二）　測定軸の数が三以上であって、国際規格で定める測定方法により空間の測定精度を測定した場合に、操作範囲内のいずれかの測定点において、測定軸のマイクロメートルで表した最大許容長さ測定誤差の数値がミリメートルで表した当該測定軸の長さに〇・〇〇一二五を乗じて得た数値に一・七を加えた数値以下となるもの

2. those with three or more measurement axes, and when the measurement accuracy of space is measured using the measurement method specified by the International Standard, at any of the measuring points within the operating range, the numerical value of the maximum permissible error for the length of the measurement axis measured expressed in micrometers is less than the numerical value to which 1.7 is added to the numerical value obtained by multiplying the length of thet measurement axis expressed in millimeters by 0.00125;

ロ　直線上の変位を測定するものであって、次のいずれかに該当するもの

(b) measuring equipment for measuring displacement on a straight line, which falls under any of the following equipment:

（一）　非接触型の測定装置であって、〇・二ミリメートルまでの測定レンジにおいて、分解能が〇・二マイクロメートル以下のもの

1. non-contact type measuring equipment with a resolving power of 0.2 micrometers or less at a measuring range of up to 0.2 millimeters;

（二）　線形可変差動変圧器（ＬＶＤＴ）を用いた測定装置であって、次の１及び２に該当するもの

2. measuring equipment using a linear variable differential transformer (LVDT), which falls under the following clauses i. and ii.:

１　線形可変差動変圧器（ＬＶＤＴ）が次のいずれかに該当するもの

i. one whose linear variable differential transformer (LVDT) falls under any of the following cases:
一　最大の作動範囲がプラスマイナス五ミリメートル以下のものであって、〇から最大の作動範囲における直線性が〇・一パーセント以下のもの
a. an LVDT with the maximum operating range of plus or minus 5 millimeters or less, and a linearity of 0.1% or less from zero to the maximum operating range; or
二　最大の作動範囲がプラスマイナス五ミリメートルを超えるものであって、〇からプラスマイナス五ミリメートルにおける直線性が〇・一パーセント以下のもの
b. an LVDT with the maximum operating range of more than plus or minus 5 millimeters and a linearity of 0.1% or less from zero to plus or minus 5 millimeters;
２　一九度以上二一度以下の温度範囲において測定した場合に、ドリフトが二四時間当たり〇・一パーセント以下のもの
ii. one with a drift of 0.1% or less per 24 hours when measured within a temperature range of 19 degrees centigrade or more and 21 degrees centigrade or less;
（三）　次の１及び２に該当するもの（フィードバック機能を有しない干渉計であって、レーザーを用いて工作機械、測定装置又はこれらに類するもののスライド運動誤差を測定するものを除く。）
3. measuring equipment that fall under the following clauses i. and ii (excluding interferometers which have no feedback function and measures slide movement errors of machine tools, measuring equipment, or devices similar to them by using lasers):
１　レーザー光を用いて測定することができるもの
i. those capable of making measurements by using laser beams;
２　一九度以上二一度以下の温度範囲において、次の一及び二の特性を一二時間維持することができるもの
ii. those capable of maintaining the properties referred to in the following clauses a. and b. for 12 hours within a temperature range of 19 degrees centigrade or more and 21 degrees centigrade or less:
一　測定できる最大の測定レンジにおいて、分解能が〇・一マイクロメートル以下のもの
a. those with a resolving power of 0.1 micrometers or less within the maximum measurement range in which measurement can be made;
二　測定範囲内のいずれか一の点において、空気屈折率で補正した場合に、測定軸のマイクロメートルで表した測定の不確かさの数値がミリメートルで表した当該測定軸の長さに〇・〇〇〇五を乗じて得た数値に〇・二を加えた数値以下のもの
b. at any single point within the measurement range, when the

measurement is corrected by air refractive index, the numerical value of uncertainty of measurement of the measurement axis expressed in micrometers is less than the numerical value to which 0.2 is added to the numerical value obtained by multiplying the length of the measurement axis expressed in millimeters by 0.0005;

ハ　角度の変位を測定するものであって、角度位置の偏差の最大値が〇・〇〇〇二五度以下のもの（平行光線を用いて鏡の角度の変位を測定する光学的器械（オートコリメータを含む。）を除く。）

(c) those for measuring angular displacement, with a maximum angular location deviation of 0.00025 degrees or less (excluding optical instruments that measure angular displacement using parallel light rays (including autocollimators));

ニ　曲面形状を有するものの長さ及び角度を同時に測定することができる測定装置であって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(d) measuring equipment capable of simultaneously measuring the length and angle of objects that have curved shapes, which fall under the following clauses 1. and 2.:

（一）　測定軸の測定の不確かさの数値が測定距離五ミリメートル当たり三・五マイクロメートル以下のもの

1. those with a numerical value for uncertainty of measurement for the measurement axis of 3.5 micrometers or less per 5 millimeters of measurement distance;

（二）　角度位置の偏差の最大値が〇・〇二度以下のもの

2. those with a maximum value of angular position deviation of 0.02 degrees or less;

十八　誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するもの

(xviii) induction furnaces, arc furnaces or plasma melting furnaces or electron-beam melting furnaces, or their components or auxiliary equipment, which fall under any of the following sub-items:

イ　真空誘導炉若しくは不活性ガスを用いる誘導炉（半導体ウエハーの加工用のものを除く。）であって、次の（一）から（三）までのすべてに該当するもの又はこれらの電源装置であって、出力が五キロワット以上のもの

(a) vacuum induction furnaces or induction furnaces that use inert gases (excluding those used for processing semiconductor wafers), which fall under all of the following clauses 1. through 3. or their power units, with an output of 5 kilowatts or more:

（一）　炉の内部を八五〇度を超える温度にすることができるもの

1. those capable of heating the interior to a temperature exceeding 850 degrees centigrade;

（二）　直径が六〇〇ミリメートル以下の誘導コイルを有するもの

2. those that have an induction coil with a diameter of 600 millimeters or less;

（三）　電源装置からの入力が五キロワット以上のもの

3. those with an input from the power unit of 5 kilowatts or more;

ロ　アーク溶解炉、アーク再溶解炉又はアーク溶解鋳造炉であって、真空中若しくは不活性ガス中で金属を溶解して鋳造するもののうち、容量が一、〇〇〇立方センチメートル超二〇、〇〇〇立方センチメートル未満の消耗電極を有し、かつ、一、七〇〇度を超える温度で金属を溶解することができるもの

(b) among arc melting furnaces, arc remelting furnaces or arc melting casting furnaces which melt and cast metal in a vacuum or in inert gas, those that possess consumable electrodes with a capacity exceeding 1,000 cubic centimeters and less than 20,000 cubic centimeters, and, are capable of melting metal at a temperature exceeding 1,700 degrees centigrade;

ハ　電子ビーム溶解炉、プラズマアトマイズ炉又はプラズマ溶解炉であって、真空中若しくは不活性ガス中で金属を溶解して鋳造するもののうち、出力が五〇キロワット以上で、かつ、一、二〇〇度を超える温度で金属を溶解することができるもの

(c) among electron-beam melting furnaces, plasma atomization furnaces, or plasma melting furnaces which melt and cast metal in a vacuum or in inert gas, those whose output is 50 kilowatts or more, and, are capable of melting metal at a temperature that exceeds 1,200 degrees centigrade;

ニ　ロ又はハに該当する炉用の電子計算機を用いた制御装置又は監視装置

(d) control device or monitors using a computer for the furnaces falling under sub-item (b) or (c);

ホ　ハに該当する炉用に特に設計されたプラズマトーチであって、出力が五〇キロワット以上のもののうち、一、二〇〇度を超える温度で金属を溶解することができるもの

(e) among plasma torches specially designed for the furnaces falling under sub-item (c), whose output is 50 kilowatts or more, those capable of melting metal at a temperature that exceeds 1,200 degrees centigrade; or

ヘ　ハに該当する炉用に特に設計された電子ビーム銃であって、出力が五〇キロワット以上のもの

(f) an electron beam gun specially designed for the furnaces falling under sub-item (c), whose output is 50 kilowatts or more;

十九　アイソスタチックプレスであって、次のイ及びロに該当するもの又はその制御装置若しくは当該アイソスタチックプレスに用いることができるように設計した型

(xix) an isostatic pressing machine falling under the following sub-items (a) and (b), or its control or mold designed to be used for theisostatic press:

イ　最大圧力が六九メガパスカル以上のもの

(a) one with a maximum pressure of 69 megapascals or more;

ロ　中空室の内径が一五二ミリメートルを超えるもの

(b) one whose hollow chamber has an internal diameter that exceeds 152 millimeters;

二十　ロボット（操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。）若しくはエンドエフェクターであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの制御装置

(xx) a robot (excluding operating robots and sequence robots) or an end effector that fall under any of the following robots or end effectors, or their control device:

イ　産業標準化法（昭和二十四年法律第百八十五号）に基づく日本産業規格（以下単に「日本産業規格」という。）Ｃ六〇〇七九―〇号（爆発性雰囲気で使用する電気機械器具―第〇部：一般要件）で定める防爆構造のもの（塗装用のものを除く。）

(a) those with an explosion-proof structure (excluding those used for painting) specified by the Japan Industrial Standard (simply referred to as "JIS" below) C60079-0 (Electric appliances for explosive gas atmospheres - Part 0 Equipment - General requirements) based on the Industrial Standardization Act (Act No. 185, 1949);

ロ　全吸収線量がシリコン換算で五〇、〇〇〇グレイを超える放射線照射に耐えることができるように設計したもの

(b) those designed to be capable of withstanding irradiation with a total absorption line volume that exceeds 50,000 grays on a silicon conversion basis;

二十一　振動試験装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(xxi) vibration testing device or its components that fall under any of the following devices:

イ　デジタル制御方式であり、かつ、電動式の振動試験装置であって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(a) those with a digital control system, and, are electrically operated which falls under the following clauses 1. and 2.:

（一）　試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上のものであって、二〇ヘルツ超二、〇〇〇ヘルツ未満の周波数範囲で加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒以上の振動を発生させることができるもの

1. one with an excitation force of 50 kilonewtons or more in a state in which there is no test specimen, and capable of generating vibrations with an effective value of acceleration 98 meters per second squared or more, in a frequency range exceeding 20 hertz and less than 2,000 hertz;

（二）　フィードバック制御技術又は閉ループ制御技術を用いたもの

2. one that uses feedback control technology or closed-loop control technology;

ロ　振動試験装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(b) components of vibration testing device that fall under any of the following clauses:

（一）　イに該当する振動試験装置の制御に使用するように設計した部分品であって、振動試験用のプログラムを用いたものであり、かつ、五キロヘルツを超える帯域幅で実時間での振動試験をデジタル制御するもの

1. those designed to be used for controling vibration testing device that fall under sub-item (a), which use programs for vibration tests, and, digitally control vibration tests in real time in a bandwidth exceeding 5 kilohertz;

（二）　イに該当する振動試験装置に使用することができる振動発生機であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上のもの

2. vibration generators usable for vibration testing device that fall under sub-item (a), with an excitation force of 50 kilonewtons or more in a state in which there is no test specimen;

（三）　イに該当する振動試験装置に使用することができる振動台又は振動発生装置の部分品であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上となる振動を発生させるために二台以上の振動発生機を接続して使用するように設計したもの

3. components of vibration tables or vibration generators usable for vibration testing device that fall under sub-item (a), designed for use by connecting two or more vibration generators in order to generate vibrations with exciting force of 50 kilonewtons or more in a state in which there is no test specimen;

二十二　ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であって、次のいずれかに該当するもの

(xxii) structural materials usable for gas centrifuge rotors that fall under any of the following materials:

イ　アルミニウム合金（鍛造したものを含む。）であって、引張強さが二〇度の温度において四六〇メガパスカル以上となるもののうち、外径が七五ミリメートルを超える棒又は円筒形のもの

(a) among aluminum alloys (including forged alloys) with a tensile strength of 460 megapascals or more at 20 degrees centigrade, those with a rod or cylindrical shape and an external diameter exceeding 75 millimeters;

ロ　炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品であって、次のいずれかに該当するもの

(b) prepreg made using carbon fibers, aramid fibers or glass fibers, or molded products made using carbon fibers or glass fibers, or carbon fibers or aramid fibers, which fall under any of the following clauses:

（一）　炭素繊維又はアラミド繊維であって、次のいずれかに該当するもの

1. carbon fibers or aramid fibers that fall under any of the following clauses:

1　比弾性率が一二、七〇〇、〇〇〇メートル以上のもの

i. those with a specific modulus of 12,700,000 meters or more;

２　比強度が二三五、〇〇〇メートル以上のもの

ii. those with a specific strength of 235,000 meters or more;

（二）　ガラス繊維であって、次の１及び２に該当するもの

2. glass fibers that fall under the following clauses i. and ii.:

１　比弾性率が三、一八〇、〇〇〇メートル以上のもの

i. those with a specific modulus of 3,180,000 meters or more;

２　比強度が七六、二〇〇メートル以上のもの

ii. those with a specific strength of 76,200 meters or more;

（三）　（一）又は（二）に該当する炭素繊維又はガラス繊維に熱硬化性樹脂を含浸したプリプレグであって、次のいずれかに該当するもの

3. prepreg consisting of carbon fibers or glass fibers impregnated with thermosetting resin that fall under the clause 1. or 2., which falls under any of the following prepregs:

１　繊維状のもの

i. those that are fibrous;

２　幅が一五ミリメートル以下のテープ状のもの

ii. those that are tape-shaped with a width of 15 millimeters or less;

（四）　（一）に該当する繊維又は（三）に該当するプリプレグ（炭素繊維を使用したものに限る。）を用いた円筒形の成型品であって、内径が七五ミリメートル超四〇〇ミリメートル未満のもの

4. molded products with a cylindrical shape that use fibers falling under clause 1. or prepreg falling under clause 3. (limited to those that use carbon fiber) with an internal diameter exceeding 75 millimeters and less than 400 millimeters;

ハ　マルエージング鋼であって、引張強さが二〇度の温度において一、九五〇メガパスカル以上となるもののうち、寸法の最大値が七五ミリメートルを超えるもの

(c) among maraging steels with a tensile strength of 1,950 megapascals or more at 20 degrees centigrade, those whose maximum dimension exceeds 75 millimeters;

ニ　チタン合金（鍛造したものを含む。）であって、引張強さが二〇度の温度において九〇〇メガパスカル以上となるもののうち、外径が七五ミリメートルを超える棒又は円筒形のもの

(d) among titanium alloys (including forged alloys) with a tensile strength of 900 megapascals or more at 20 degrees centigrade, those with a rod or cylindrical shape which has an external diameter exceeding 75 millimeters;

二十三　ベリリウム若しくはベリリウム合金（ベリリウムの含有量が全重量の五〇パーセントを超えるものに限る。）の地金若しくはくず若しくはベリリウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品

(xxiii) metals or scrap of beryllium or beryllium alloys (limited to those with a beryllium content that exceeds 50% of the total weight) or beryllium compounds, or their primary or semi-processed products;

二十四　核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質であって、次のいずれかに該当するもの

(xxiv) substances used in alpha sources for detonating nuclear weapons, or their raw materials, which fall under any of the following sub-items:

イ　重量比による純度が九九・九九パーセント以上のビスマスであって、銀の含有量が全重量の〇・〇〇一パーセント未満のもの

(a) bismuth with a weight-based purity level of 99.99% or more, which has a silver content of less than 0.001% of the total weight;

ロ　ラジウム二二六、ラジウム二二六合金、ラジウム二二六化合物若しくはラジウム二二六混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品（医療用装置に組み込まれたもの及び装置に内蔵されたものであって一装置当たりの放射能の総量が〇・三七ギガベクレル未満のものを除く。）

(b) radium 226, radium 226 alloys, radium 226 compounds or radium 226 mixtures, or their primary or semi-processed products (excluding those incorporated and installed in medical devices, and the total amount of radioactivity per device is less than 0.37 gigabecquerels);

ハ　アルファ中性子反応により中性子源を発生させるに適した放射性核種又はその化合物若しくは混合物（装置に内蔵された化合物又は混合物であって、一装置当たりの崩壊による放射能の総量が三・七ギガベクレル未満のものを除く。）であって、一キログラム当たりの崩壊による放射能の総量が三七ギガベクレル以上のもの

(c) radioactive nuclide suitable for generating neutron sources by alpha-neutron reaction, or its compounds or mixtures (excluding those installed in a device, for which the total amount of radioactivity per device is less than 3.7 gigabecquerels), with a total amount of radioactivity per kilogram of 37 gigabecquerels or more;

二十五　ほう素、ほう素化合物若しくはほう素混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品であって、ほう素一〇のほう素一〇及びほう素一一に対する比率が天然の比率を超えて濃縮されたほう素から構成されるもの又はそのほう素を含むもの

(xxv) boron, boron compounds or boron mixtures, or their primary or semi-processed products, composed of concentrated boron with a ratio of boron 10 to boron 10 and boron 11 is greater than the ratio of boron 10 in nature, or products containing such boron;

二十六　核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用いられる物質であって、次のいずれかに該当するもの

(xxvi) substances that are used as reducing agent or oxidizing agent for producing nuclear fuel materials, which fall under any of the following sub-items:

イ　カルシウムであって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(a) calcium that fall under the following clauses 1. and 2.:

（一）　カルシウム又はマグネシウム以外の金属の含有量が全重量の〇・一パー

セント未満のもの

1. those with a content of metals other than calcium or magnesium of less than 0.1% of the total weight;

（二）　ほう素の含有量が全重量の〇・〇〇一パーセント未満のもの

2. those with a boron content of less than 0.001% of the total weight;

ロ　三ふっ化塩素

(b) chlorotrifluorine;

ハ　マグネシウムであって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(c) magnesium that fall under the following clauses 1. and 2.:

（一）　マグネシウム又はカルシウム以外の金属の含有量が全重量の〇・〇二パーセント未満のもの

1. those with a content of metals other than magnesium or calcium of less than 0.02% of the total weight;

（二）　ほう素の含有量が全重量の〇・〇〇一パーセント未満のもの

2. those with a boron content of less than 0.001% of the total weight;

二十七　アクチニドに対して耐食性のある材料を用いたるつぼであって、次のいずれかに該当するもの

(xxvii) crucibles that uses materials that are corrosion-resistant against actinide, which fall under any of the following crucibles:

イ　容量が〇・一五リットル超八リットル未満のるつぼであって、次のいずれかに該当する材料若しくはこれらを組み合わせたもの（不純物の総重量の当該るつぼの総重量に対する割合が二パーセント以下のものに限る。）からなるもの又はその材料により被覆されたもの

(a) those with a capacity exceeding 0.15 liters and less than 8 liters, made from or coated with materials that fall under any of the following clauses, or their combination (limited to those that has a ratio of the total weight of impurities to the total weight of the crucible of 2% or less):

（一）　ふっ化カルシウム

1. calcium fluoride;

（二）　メタジルコン酸カルシウム

2. calcium metazirconate;

（三）　硫化セリウム

3. cerium sulfide;

（四）　酸化エルビウム

4. erbium oxide;

（五）　酸化ハフニウム

5. hafnium oxide;

（六）　酸化マグネシウム

6. magnesium oxide;

（七）　ニオブ、チタン及びタングステンからなる合金であって、窒化したもの

7. nitride of alloys containing niobium, titanium and tungsten;

（八）　酸化イットリウム

8. yttrium oxide;

（九）　酸化ジルコニウム

9. zirconium oxide;

ロ　容量が〇・〇五リットル超二リットル未満のるつぼであって、重量比による純度が九九・九パーセント以上のタンタル製のもの又はそのタンタルで裏打ちされたもの

(b) crucibles with a capacity exceeding 0.05 liters and less than 2 liters, made from or lined with tantalum with a weight-based purity of 99.9% or more;

ハ　容量が〇・〇五リットル超二リットル未満のるつぼであって、重量比による純度が九八パーセント以上のタンタル製のもの又はそのタンタルで裏打ちされたもののうち、タンタルの炭化物、窒化物、ほう化物又はこれらのいずれかを組み合わせたもので被覆されたもの

(c) among crucibles with a capacity exceeding 0.05 liters and less than 2 liters, made from or lined with tantalum with a weight-based purity of 98% or more, those that are coated with tantalum carbide, tantalum nitride, tantalum boride, or their combination;

二十八　ハフニウム若しくはハフニウム合金（ハフニウムの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるものに限る。）の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物（ハフニウムの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるものに限る。）又はこれらの半製品若しくは一次製品

(xxviii) metals or scrap of hafnium or hafnium alloys (limited to those with a hafnium content that exceeds 60% of the total weight) or hafnium compounds (limited to those with a hafnium content that exceeds 60% of the total weight), or their primary products or their semi-processed products;

二十九　リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品であって、リチウム六のリチウム六及びリチウム七に対する比率が天然の比率を超えて濃縮されたリチウムから構成されるもの又はそのリチウムを含むもの（熱ルミネセンス線量計に組み込まれたリチウム化合物又はリチウム混合物を除く。）

(xxix) metals or scraps of lithium or lithium alloys or lithium compounds or mixtures, or their primary products or their semi-processed products, composed of concentrated lithium with a ration of lithium 6 to lithium 6 and lithium 7 which is greater than the ratio of lithium in nature, or containing such lithium (excluding lithium compounds and lithium mixtures incorporated in thermoluminescence dosimeters);

三十　タングステン、タングステンの炭化物又はタングステンの含有量が全重量の九〇パーセントを超える合金であって、質量が二〇キログラムを超え、かつ、内径が一〇〇ミリメートル超三〇〇ミリメートル未満の円筒形のもの若しくは中空の半球形のもの又はこれらを組み合わせたもの（おもり又はガンマ線のコリメータ用に設計されたものを除く。）

(xxx) tungsten, tungsten carbide, or alloys with a tungsten content that exceeds 90% of the total weight, with a mass exceeding 20 kilograms, and, has a cylindrical shape with an internal diameter exceeding 100 millimeters and less than 300 millimeters, or has a hemispherical shape that is hollow, or their combinations (excluding those designedto be used for a weight or gamma ray collimators);

三十一　ジルコニウム若しくはジルコニウム合金（ジルコニウムの含有量が全重量の五〇パーセントを超えるものに限る。）の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物（ハフニウムの含有量がジルコニウムの含有量の五〇〇分の一未満のものに限る。）又はこれらの半製品若しくは一次製品（厚さが〇・一ミリメートル以下のはくを除く。）

(xxxi) metals or scraps of zirconium or zirconium alloys (limited to those with a zirconium content exceeding 50% of the total weight) or zirconium compounds (limited to those with a hafnium content of less than 1/500 of the zirconium content), or their primary products or their semi-processed products (excluding a leaf with thickness of 0.1 millimeters or less);

三十二　ふっ素製造用の電解槽であって、製造能力が一時間当たり二五〇グラムを超えるもの

(xxxii) electrolytic cells for producing fluorine with a production capability exceeding 250 grams per hour;

三十三　ガス遠心分離機のロータの製造用若しくは組立用の装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(xxxiii) devices for producing or assembling gas centrifuge rotors, or their components, which fall under any of the following sub-items:

イ　ガス遠心分離機のロータのチューブ、バッフル及びエンドキャップの組立用の装置

(a) a device used for assembling gas centrifuge rotor tubes, baffles, and end caps;

ロ　ガス遠心分離機のロータのチューブの中心軸を調整するための装置

(b) a device used for adjusting the center axis of gas centrifuge rotor tubes;

ハ　次の（一）から（三）までのすべてに該当するベローズ（アルミニウム合金、マルエージング鋼又は繊維で強化した複合材料からなるものに限る。）の製造用のマンドレル又は型

(c) mandrels or molds used for manufacturing bellows falling under all of the following clauses 1. through 3. (limited to those made from aluminum alloys, maraging steel, or fiber-reinforced composite materials):

（一）　内径が七五ミリメートル超四〇〇ミリメートル未満のもの

1. those with an internal diameter exceeding 75 millimeters and less than 400 millimeters;

（二）　溝のピッチが一二・七ミリメートル以上のもの

2. those with pitch of groove which is 12.7 millimeters or more;

（三）　溝の深さが二ミリメートルを超えるもの

3. those with depth of groove which exceeds 2 millimeters;

三十四　遠心力式釣合い試験機（一面釣合い試験機を除く。）であって、次のいずれかに該当するもの（第三条第十七号の三ロに該当するものを除く。）

(xxxiv) centrifugal balancing machines (excluding single-plane balancing machines) that fall under any of the following sub-items (excluding those that fall under Article 3, item (xvii)-3, sub-item (b)):

イ　長さが六〇〇ミリメートル以上の弾性ロータを試験することができるように設計したものであって、次の（一）から（三）までのすべてに該当するもの

(a) those that are designed to be capable of testing elastic rotors with a length of 600 millimeters or more, that fall under all of the following clauses 1. through 3.:

（一）　外径が七五ミリメートルを超える弾性ロータを試験することができるもの又はジャーナルの径が七五ミリメートルを超えるもの

1. those capable of testing elastic rotors with an external diameter that exceeds 75 millimeters or with a journal diameter that exceeds 75 millimeters;

（二）　重量が〇・九キログラム以上二三キログラム以下の弾性ロータを試験することができるもの

2. those capable of testing elastic rotors with a weight of 0.9 kilograms or more and 23 kilograms or less;

（三）　一分につき五、〇〇〇回転を超える回転数で試験することができるもの

3. those capable of conducting a test at 5,000 rounds or more per minute;

ロ　円筒形のロータを試験することができるように設計したものであって、次の（一）から（四）までの全てに該当するもの

(b) those that are designed to be capable of testing cylindrical rotors, which fall under all of the following clauses 1. through 4.:

（一）　ジャナールの径が七五ミリメートルを超えるもの

1. those with a journal diameter that exceeds 75 millimeters;

（二）　重量が〇・九キログラム以上二三キログラム以下のロータを試験することができるもの

2. those capable of testing rotors a weight of 0.9 kilograms or more and 23 kilograms or less;

（三）　修正面上の到達最小比不釣合いが一キログラム当たり一〇グラムミリメートル以下のもの

3. those with a minimum achievable residual unbalance on the correction plane of less than 10 grams millimeters per kilogram;

（四）　ベルト駆動式のもの

4. those with a belt drive mechanism;

三十五　フィラメントワインディング装置であって、次のイ及びロに該当するもの又はその制御装置若しくはマンドレル

(xxxv) filament winding machines that fall under the following sub-items (a) and (b), or their control device or mandrel:

イ　繊維を位置決めし、包み及び巻く作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が二以上のもの

(a) among those that perform positioning of filaments and conduct wrapping and winding operations, those with two or more axes that are capable of controlling those operations in correlation;

ロ　内径が七五ミリメートル超六五〇ミリメートル未満であって、かつ、長さが三〇〇ミリメートル以上の円筒形のチューブを製造することができるもの

(b) those capable of manufacturing cylindrical tubes with an internal diameter that exceed 75 millimeters and less than 650 millimeters, and, has a length of 300 millimeters or more;

三十六　ガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの

(xxxvi) gas laser oscillators, solid-state laser oscillators, or dye laser oscillators, which fall under any of the following sub-items:

イ　五〇〇ナノメートル超六〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した金属蒸気レーザー発振器（銅レーザー発振器に限る。）であって、平均出力が三〇ワット以上のもの

(a) metal vapor laser oscillators (limited to copper laser oscillators) that are designed to be used within a wavelength range that exceeds 500 nanometers and less than 600 nanometers, with an average output of 30 watts or more;

ロ　四〇〇ナノメートル超五一五ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したアルゴンイオンレーザー発振器であって、平均出力が四〇ワットを超えるもの

(b) argon ion laser oscillators that are designed to be used within a wavelength range that exceeds 400 nanometers and less than 515 nanometers, with an average output exceeding 40 watts;

ハ　九、〇〇〇ナノメートル超一一、〇〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した二酸化炭素レーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次の（一）から（三）までのすべてに該当するもの

(c) among carbon dioxide laser oscillators that are designed to be used within a wavelength range that exceeds 9,000 nanometers and less than 11,000 nanometers and are designed to generate a pulse, those falling under all of the following clauses 1. through 3.:

（一）　パルス繰返し周波数が二五〇ヘルツを超えるもの

1. those with a pulse repetition frequency that exceeds 250 hertz;

（二）　平均出力が五〇〇ワットを超えるもの

2. those with an average output that exceeds 500 watts; and

（三）　パルス幅が二〇〇ナノ秒未満のもの

3. those with a pulse width of 200 nanoseconds or less;

ニ　二四〇ナノメートル超三六〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したエキシマレーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次の（一）及び（二）に該当するもの

(d) among excimer laser oscillators that are designed to be used within a wavelength range that exceeds 240 nanometers and less than 360 nanometers and are designed to generate a pulse, those falling under the following clauses 1. and 2.:

（一）　パルス繰返し周波数が二五〇ヘルツを超えるもの

1. those with a pulse repetition frequency that exceeds 250 hertz; and

（二）　平均出力が五〇〇ワットを超えるもの

2. those with an average output that exceeds 500 watts;

ホ　一六マイクロメートルの波長で用いるように設計したパラ水素を用いたラマンレーザー発振器であって、パルス繰返し周波数が二五〇ヘルツを超えるもの

(e) raman laser oscillators using parahydrogen that are designed to be used at a wavelength of 16 micrometers, with a pulse repetition frequency that exceeds 250 hertz;

ヘ　七二〇ナノメートル超八〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したアレキサンドライトレーザー発振器であって、次の（一）から（三）までのすべてに該当するもの

(f) alexandrite laser oscillators that are designed to be used within a wavelength range that exceeds 720 nanometers and less than 800 nanometers, which fall under all of the following clauses 1. through 3.:

（一）　パルス繰返し周波数が一二五ヘルツを超えるもの

1. those with a pulse repetition frequency that exceeds 125 hertz;

（二）　平均出力が三〇ワットを超えるもの

2. those with an average output that exceeds 30 watts; and

（三）　レーザー光のスペクトル線幅が〇・〇〇五ナノメートル以下のもの

3. those with a laser beam spectral line width of 0.005 nanometers or less;

ト　一、〇〇〇ナノメートル超一、一〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したネオジムを添加した固体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの（ネオジムガラスレーザー発振器を除く。）

(g) fixed laser oscillators with neodymium added that are designed to be used within a wavelength range that exceeds 1,000 nanometers and less than 1,100 nanometers, which fall under any of the following oscillators (excluding neodymium glass laser oscillators):

（一）　パルス励起及びキュースイッチを用いたものであって、一ナノ秒以上のパルス幅のパルスを発振するもののうち、次のいずれかに該当するもの

1. among those that use pulse excitation and a Q-switch which emit a pulse with a pulse width of 1 nanosecond or more, those that fall under either of the following clauses:

１　単一横モードのパルスを発振するものであって、平均出力が四〇ワットを超えるもの

i. those that emit a single-transverse-mode pulse, with an average output that exceeds 40 watts; or

２　多重横モードのパルスを発振するものであって、平均出力が五〇ワットを超えるもの

ii. those that emit a multi-transverse-mode pulse, with an average output that exceeds 50 watts;

（二）　波長範囲が五〇〇ナノメートル超五五〇ナノメートル未満で、かつ、平均出力が四〇ワットを超える第二高調波を発生するように設計したもの

2. those that are designed to generate a second harmonic wave within the frequency range that exceeds 500 nanometers and less than 550 nanometers, and, with an average output that exceeds 40 watts;

チ　三〇〇ナノメートル超八〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した色素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの

(h) dye laser oscillators that are designed to be used within a wavelength range that exceeds 300 nanometers and less than 800 nanometers, which fall under any of the following oscillators:

（一）　単一モードのパルスを発振する波長可変レーザー発振器（レーザー光の増幅のみを行う装置を除く。）であって、次の１から３までのすべてに該当するもの

1. variable wavelength laser oscillators that emits a single-mode pulse (excluding those that only amplify laser light) that fall under all of the following clauses i. through iii.:

１　パルス繰返し周波数が一キロヘルツを超えるもの

i. those with a pulse repetition frequency that exceeds 1 kilohertz;

２　平均出力が一ワットを超えるもの

ii. those with an average output that exceeds 1 watt; and

３　パルス幅が一〇〇ナノ秒未満のもの

iii. those with a pulse width of less than 100 nanoseconds;

（二）　パルスを発振する波長可変レーザー発振器であって、次の１から３までのすべてに該当するもの（（一）に該当するものを除く。）

2. variable wavelength oscillators that emit a pulse, which fall under all of the following clauses i. through iii. (excluding those that falling under clause 1.):

１　パルス繰返し周波数が一キロヘルツを超えるもの

i. those with a pulse repetition frequency that exceeds 1 kilohertz;

２　平均出力が三〇ワットを超えるもの

ii. those with an average output that exceeds 30 watts; and

３　パルス幅が一〇〇ナノ秒未満のもの

iii.those with a pulse width of less than 100 nanoseconds;

リ　五、〇〇〇ナノメートル超六、〇〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した一酸化炭素レーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次の（一）から（三）までの全てに該当するもの

(i) among carbon monoxide laser oscillators that are designed to be used within a wavelength range that exceeds 5,000 nanometers and less than 6,000 nanometers and are designed to generate a pulse, those that fall under all of the following clauses 1. through 3.:

（一）　パルス繰返し周波数が二五〇ヘルツを超えるもの

1. those with a pulse repetition frequency that exceeds 250 hertz;

（二）　平均出力が二〇〇ワットを超えるもの

2. those with an average output that exceeds 200 watts; and

（三）　パルス幅が二〇〇ナノ秒未満のもの

3. those with a pulse width of 200 nanoseconds or less;

三十七　質量分析計であって、統一原子質量単位で表した質量が二三〇以上のイオンを測定することができ、かつ、二三〇における原子質量の差が二未満のイオンを区別することができる分解能のもののうち、次のイからホまでのいずれかに該当するもの（へに該当するものを除く。）又は当該質量分析計に用いることができるイオン源

(xxxvii) among mass spectrometers capable of measuring ions with a mass of more than 230 expressed in unified atomic mass units, and, have the resolving power to distinguish ions with a mass of 230 when the difference of atomic mass between the ions is less than 2, those that fall under any of the following sub-items (a) through (e) (excluding those that fall under sub-item (f)) or ion sources usable for those mass spectrometers:

イ　誘導結合プラズマを用いたもの

(a) those that use inductively coupled plasma;

ロ　グロー放電を用いたもの

(b) those that use glow discharge; or

ハ　熱電離を用いたもの

(c) those that use thermal ionization;

ニ　分析される物質に電子を衝突させてイオン化するイオン源を有するものであって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(d) those possessing an ion source that ionizes by causing electrons to collide with substances to be analyzed, which fall under the following clauses 1. and 2.:

（一）　電子ビームを用いて分子がイオン化されるイオン源領域に、分析される物質の分子の平行ビームを照射する装置を有するもの

1. those possessing a device that irradidates parallel beams of molecules of substances to be analyzed on the ion source area where molecules are ionized using electron beams; and

（二）　分析される物質の分子の平行ビーム中の電子ビームを用いてイオン化さ

れない分子を捕捉するため、零下八〇度以下の温度となることができるコールドトラップを一以上有するもの

2. those possessing one or more cold traps capable of attaining temperatures of minus 80 degrees centigrade or less to capture molecules that are not ionized using electron beams in parallel beams of molecules of substances to be analyzed;

ホ　アクチニド又はそのふっ化物のイオン化用に設計したイオン源を有するもの

(e) those possessing an ion source that is designed for ionizing actinides or their fluorides;

ヘ　次の（一）から（五）までの全てに該当するもの

(f) those that fall under all of the following clauses 1. through 5.:

（一）　原子質量単位で表した質量が三二〇以上のイオンを測定することができるものであって、原子質量単位での分解能が三二〇を超えるもの

1. those capable of measuring ions with a mass of 320 or more expressed in atomic weight units, which have a resolving power of more than 320 expressed in atomic weight units;

（二）　イオン源が、ニッケル、ニッケルの含有量が全重量の六〇パーセント以上のニッケル銅合金又はニッケルクロム合金で作られた又はこれらの材料で保護されたもの

2. those whose ion source is made from nickel, nickel copper alloys with a nickel content of 60% or more of the total weight, or nickel chrome alloys, or those protected by such materials;

（三）　分析される物質に電子を衝突させてイオン化するイオン源を有するもの

3. those possessing an ion source that ionizes by causing electrons to collide with substances to be analyzed;

（四）　同位元素の分析に用いることができるコレクタを有するもの

4.those possessing a collector usable for analyzing isotopes; and

（五）　六ふっ化ウランのガスの流れを止めずに試料を採取することができるように設計したもの

5. those that are designed so that they can collect samples without stopping the flow of uranium hexafluoride gas;

三十八　圧力計又はベローズ弁であって、次のいずれかに該当するもの

(xxxviii) pressure gauges or bellows valves, which fall under any of the following sub-items:

イ　絶対圧力を測定することができる圧力計であって、次の（一）から（三）まで（センサを密閉するためのシールを用いていないものについては、（二）を除く。）の全てに該当するもの

(a) pressure gauges capable of measuring absolute pressure, which fall under all of the following clauses 1. through 3. (for those that do not use a seal to tightly shut sensors, excluding clause 2.):

（一）　アルミニウム、アルミニウム合金、酸化アルミニウム、ニッケル、ニッ

ケルの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるニッケル合金若しくはふっ素化炭化水素ポリマーで作られた又はこれらの材料で保護されたセンサを用いたもの

1. those that use a sensor made from aluminum, aluminum alloys, aluminum oxide, nickel, nickel alloys with a nickel content exceeding 60% of the total weight or fluorinated hydrocarbon polymers, or a sensor protected by such materials; and

（二）　センサを密閉するために必要不可欠であり、内容物と直接接触し、アルミニウム、アルミニウム合金、酸化アルミニウム、ニッケル、ニッケルの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるニッケル合金若しくはふっ素化炭化水素ポリマーで作られた又はこれらの材料で保護されたシールを用いたもの

2. those indispensable to tightly shut sensors, and use a seal that come into direct contact with the contents, and made from aluminum, aluminum alloys, aluminum oxide, nickel, nickel alloys with a nickel content exceeding 60% of the total weight or fluorinated hydrocarbon polymers, or a seal protected by such materials;

（三）　次のいずれかに該当するもの

3. those that fall under any of the following clauses:

１　フルスケールが一三キロパスカル未満であるとき、いずれかのフルスケールにおいて、精度がフルスケールのプラスマイナス一パーセント未満のもの

i. when the full scale is less than 13 kilopascals, those with a precision of less than plus or minus 1% of the full scale at any full scale;

２　フルスケールが一三キロパスカル以上であるとき、一三キロパスカルにおいて、精度がプラスマイナス一三〇パスカル未満のもの

ii. when the full scale is 13 kilopascals or more, those with a precision of less than plus or minus 130 pascals at 13 kilopascals;

ロ　ベローズ弁であって、呼び径が五Ａ以上のもののうち、内容物と接触する全ての部分がアルミニウム、アルミニウム合金、ニッケル又はニッケル合金（ニッケルの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるものに限る。）で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

(b) among bellows valves with a nominal diameter of 5A or more, those with which all parts that come into contact with the contents are composed of, lined with, or coated with aluminum, aluminum alloys, nickel, or nickel alloys (limited to those with a nickel content exceeding 60% of the total weight);

三十九　ソレノイドコイル形の超電導電磁石であって、次のイからニまでのすべてに該当するもの（医療用の磁気共鳴イメージング装置に用いるように設計したものを除く。）

(xxxix) solenoid coil type superconducting electromagnets that fall under all of the following sub-items (a) through (d) (excluding those that are designed to be used in clinical magnetic resonance equipment):

イ　磁束密度が二テスラを超えるもの

(a) those with magnetic flux density that exceeds 2 teslas;

ロ　コイルの長さを内径で除した値が二を超えるもの

(b) those for which the value obtained by dividing the coil length by an internal diameter exceeds 2;

ハ　コイルの内径が三〇〇ミリメートルを超えるもの

(c) those with a coil internal diameter that exceeds 300 millimeters; and

ニ　コイルの軸の中心部分を中心として内径の三五パーセントを半径とする円であって、コイルの軸に垂直なものの範囲において、磁界の均一性が一パーセント未満のもの

(d) those whose magnetic field homogeneity is less than 1% within the range of a circle with a radius of 35% of the internal diameter that is centered on the center part of the coil axis which is perpendicular to the coil axis;

四十　真空ポンプであって、吸気口の内径が三八センチメートル以上のもののうち、排気速度が一秒当たり一五、〇〇〇リットル以上で、かつ、到達圧力が一三・三ミリパスカル未満のもの

(xl) among vacuum pumps that have an intake port with an internal diameter of 38 centimeters or more, those with an exhaust speed of 15,000 liters or more per second, and, an ultimate pressure of less than 13.3 millipascals;

四十の二　スクロール型圧縮機又はスクロール型真空ポンプであって、ベローズシールを用いたもののうち、次のイからハまでの全てに該当するもの

(xl)-2 among scroll-type compressors or vacuum pumps that use bellows seals, those that fall under all of the following sub-items (a) through (c):

イ　吸気量を一時間あたり五〇立方メートル以上とすることができるもの

(a) those with an air intake quantity of 50 cubic meters or more per hour;

ロ　圧力比を二以上とすることができるもの

(b) those that are able to make the pressure ratio 2 or more; and

ハ　プロセスガスに接触する全ての面が次のいずれかの材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

(c) those in which all of the surfaces that come into contact with the process gas are composed of, lined with, or coated with any of the following materials:

（一）　アルミニウム又はアルミニウム合金

1. aluminum or aluminum alloys;

（二）　酸化アルミニウム

2. aluminum oxide;

（三）　ステンレス鋼

3. stainless steel;

（四）　ニッケル又はニッケル合金

4. nickel or nickel alloys;

（五）　燐　青銅

5. phosphorus bronze; or

（六）　ふっ素重合体

6. fluoropolymers;

四十一　直流の電源装置であって、次のいずれかに該当するもの

(xli) direct current power supply devices that fall under either of the following sub-items:

イ　出力電流が五〇〇アンペア以上のもののうち、電流又は電圧の変動率が〇・一パーセント未満で、かつ、出力電圧が一〇〇ボルト以上の状態で連続八時間を超えて使用することができるもの

(a) among those with an output current of 500 amperes or more, those with a current or voltage fluctuation rate of less than 0.1%, and, are capable of being used for more than 8 consecutive hours under an output voltage of 100 volts or more; or

ロ　出力電圧が二〇、〇〇〇ボルト以上のもののうち、電流又は電圧の変動率が〇・一パーセント未満で、かつ、出力電流が一アンペア以上の状態で連続八時間を超えて使用することができるもの

(b) among those with an output voltage of 20,000 volts or more, those with a current or voltage fluctuation rate of less than 0.1%, and, can be used for more than 8 consecutive hours with an output current of 1 ampere or more;

四十二　電子加速器又はフラッシュ放電型のエックス線装置であって、次のいずれかに該当するもの（電子顕微鏡の部分品又は医療用装置を除く。）

(xlii) electron accelerators or flash X-ray equipment, which falls under any of the following sub-items (excluding components of electron microscopes, or medical equipment):

イ　電子の運動エネルギーのせん頭値が〇・五メガ電子ボルト以上二五メガ電子ボルト未満であって、次のいずれかに該当するもの

(a) those with a peak value for kinetic energy of electrons of 0.5 megaelectron volts or more and less than 25 megaelectron volts, which fall under either of the following clause:

（一）　ビームのパルスの持続時間が一マイクロ秒以下であって、一、七〇〇にメガ電子ボルトで表した電子の運動エネルギーのせん頭値の二・六五乗を乗じたものに、クーロンで表した加速された電子の全電荷量を乗じた値が〇・二五以上のもの

1. one with a beam pulse duration of 1 microsecond or less, and the value obtained by multiplying the total charge amount of accelerated electrons expressed in coulombs by the value obtained by multiplying 1,700 by the result obtained by multiplying the peak value of the electron kinetic energy expressed in mega-electron volts by 2.56 squared is 0.25 or more; or

（二）　ビームのパルスの持続時間が一マイクロ秒を超えるものであって、一、七〇〇にメガ電子ボルトで表した電子の運動エネルギーのせん頭値の二・六五乗を乗じたものに、クーロンで表した一マイクロ秒の間に加速することができる電荷量の最大値を乗じた値が〇・二五以上のもの

2. one with a beam pulse duration exceeding 1 microsecond, and the value obtained by multiplying the total charge amount of accelerated electrons expressed in coulombs by the value obtained by multiplying 1,700 by the result obtained by multiplying the peak value of the electron kinetic energy expressed in mega-electron volts by 2.56 squared is 0.25 or more; or

ロ　電子の運動エネルギーのせん頭値が二五メガ電子ボルト以上であって、せん頭出力が五〇メガワットを超えるもの

(b) those with a peak electron kinetic energy of 25 megaelectron volts or more, and has a peak output exceeding 50 megawatts;

四十三　発射体の速度の最大値を一秒につき一・五キロメートル以上にすることができる衝撃試験機

(xliii) impact testing machines capable of making the maximum velocity of a projectile 1.5 kilometers per second or more;

四十四　高速度の撮影が可能なカメラ又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(xliv) cameras capable of high-speed shooting or their components, which fall under any of the following sub-items:

イ　ストリークカメラ又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(a) streak cameras or their components, which fall under any of the following clauses:

（一）　ストリークカメラであって、撮影速度が一マイクロ秒につき〇・五ミリメートルを超えるもの

1. streak cameras with a photographing speed that exceeds 0.5 millimeters per microsecond;

（二）　電子式のストリークカメラであって、時間分解能が五〇ナノ秒以下のもの

2. electronic streak cameras with a temporal resolution of 50 nanoseconds or less;

（三）　（二）に該当するカメラ用のストリーク管

3. streak tubes for cameras that fall under clause 2.;

（四）　モジュール式の構造を有するストリークカメラに用いるために設計したプラグインユニットであって、（一）又は（二）に該当する貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要なもの

4. plug-in units that are designed to be used in streak cameras having a modular structure, which are necessary for achieving the functions or characteristics of the goods that fall under clause 1. or 2., or for exceeding them;

（五）　（一）に該当するカメラ用に設計したタービン、反射鏡及び軸受で構成される回転反射鏡の組立品又は同期電子装置

5. assemblies of turbines, reflectors, and rotating reflectors composed of axis bearings, or synchronizing electronic equipment, which are designed

for cameras that fall under clause 1.;

ロ　フレーミングカメラ又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(b) framing cameras or their components, which fall under any of the following clauses:

（一）　フレーミングカメラであって、撮影速度が一秒につき二二五、〇〇〇こまを超えるもの

1. framing cameras with a photographing speed exceeding 225,000 frames per second;

（二）　フレーミングカメラであって、シャッター速度が五〇ナノ秒以下のもの

2. framing cameras with a shutter speed of 50 nanoseconds or less;

（三）　（一）又は（二）に該当するカメラ用に設計したフレーミング管又は固体撮像素子であって、シャッター速度が五〇ナノ秒以下のもの

3. framing tubes or solid-state image sensors that are designed for cameras falling under clause 1. or 2., with a shutter speed of less than 50 nanoseconds;

（四）　モジュール式の構造を有するフレーミングカメラに用いるために設計したプラグインユニットであって、（一）又は（二）に該当する貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要なもの

4. plug-in units that are designed to be used in framing cameras having a modular structure, which are necessary for achieving the functions or characteristics of the goods that fall under clause 1. or 2., or for exceeding them;

（五）　（一）又は（二）に該当するカメラ用に設計したタービン、反射鏡及び軸受で構成される回転反射鏡の組立品又は同期電子装置

5. assemblies of rotating reflectors composed of turbines, reflectors, and axis bearings, or synchronizing electronic equipment, which are designed for cameras that fall under clause 1. or 2.;

ハ　固体カメラ若しくは電子管カメラ又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの（イ又はロに該当するものを除く。）

(c) solid-state cameras or electron tube cameras, or their components, which fall under any of the following equipment (excluding those that fall under sub-item (a) or (b)):

（一）　固体カメラ又は電子管カメラであって、シャッター速度が五〇ナノ秒以下のもの

1. solid-state or electron tube cameras with a shutter speed of 50 nanoseconds or less;

（二）　（一）に該当するカメラ用に設計した固体撮像素子又はイメージ増強管であって、シャッター速度が五〇ナノ秒以下のもの

2. solid state image sensors or image intensifier tubes that are designed for cameras falling under clause 1. with a shutter speed of 50 nanoseconds or less;

（三）　カーセル又はポッケルスセルを用いた電気制動シャッターであって、シャッター速度が五〇ナノ秒以下のもの

3. electrically triggered shutters that use Kerr cells or Pockel cells with a shutter speed of 50 nanoseconds or less; or

（四）　モジュール式の構造を有するカメラに使用するために設計したプラグインユニットであって、（一）に該当する貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要なもの

4. plug-in units that are designed to be used in cameras having a modular structure, which are necessary for achieving the functions or characteristics of the goods that fall under clause 1., or for exceeding them;

四十五　流体の速度を測定するための干渉計又は流体の圧力を測定することができる圧力測定器若しくは水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器であって、次のいずれかに該当するもの

(xlv) interferometers for measuring fluid velocity, or pressure gauges capable of measuring fluid pressure or pressure transducers that use crystal piezoelectric pressure sensors, which fall under any of the following devices:

イ　流体の速度を測定するための干渉計であって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(a) interferometers for measuring fluid velocity, which fall under the following clauses 1. and 2.:

（一）　一秒につき一キロメートルを超える速度を測定することができるもの

1. those capable of measuring velocity that exceeds 1 kilometer per second;

（二）　一〇マイクロ秒未満の間隔で速度を測定することができるもの

2. those capable of measuring velocity at an interval of less than 10 microseconds;

ロ　一〇ギガパスカルを超える圧力を測定することができる圧力測定器

(b) pressure gauges capable of measuring pressures exceeding 10 gigapascals;

ハ　一〇ギガパスカルを超える圧力を測定することができる水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器

(c) pressure transducers that use crystal piezoelectric pressure sensors which are capable of measuring pressures exceeding 10 gigapascals;

四十六　三個以上の電極を有する冷陰極管であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの

(xlvi) cold-cathode tubes having three or more electrodes, which fall under all of the following sub-items (a) through (c):

イ　せん頭陽極電圧が二、五〇〇ボルト以上のもの

(a) those with a peak anode voltage of 2,500 volts or more;

ロ　せん頭陽極電流が一〇〇アンペア以上のもの

(b) those with a peak anode current of 100 amperes or more; and

ハ　陽極遅延時間が一〇マイクロ秒以下のもの

(c) those with an anode delay time of 10 microseconds or less;

四十七　トリガー火花間げきであって、陽極遅延時間が一五マイクロ秒以下のもののうち、せん頭電流が五〇〇アンペア以上のもの

(xlvii) among triggered spark gaps with an anode delay time of 15 microseconds or less, those with a peak current of 500 amperes or more;

四十八　スイッチングを行う機能を有する組立品であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの

(xlviii) assemblies having switching functions, which fall under all of the following sub-items (a) through (c):

イ　せん頭陽極電圧が二、〇〇〇ボルトを超えるもの

(a) those with a peak anode voltage exceeding 2,000 volts;

ロ　せん頭陽極電流が五〇〇アンペア以上のもの

(b) those with a peak anode current of 500 amperes or more; and

ハ　ターンオン時間が一マイクロ秒以下のもの

(c) those with a turn-on time of 1 microsecond or less;

四十九　パルス用コンデンサであって、次のいずれかに該当するもの

(xlix) pulse condensers that fall under either of the following sub-items:

イ　定格電圧が一、四〇〇ボルトを超えるものであって、次の（一）から（三）までのすべてに該当するもの

(a) those with a rated voltage exceeding 1,400 volts, which fall under all of the following clauses 1. through 3.:

（一）　総エネルギーが一〇ジュールを超えるもの

1. those whose total energy exceeds 10 joules;

（二）　公称静電容量が〇・五マイクロファラドを超えるもの

2. those whose nominal capacitance exceeds 0.5 microfarads;

（三）　直列インダクタンスが五〇ナノヘンリー未満のもの

3. those whose series inductance is less than 50 nanohenries;

ロ　定格電圧が七五〇ボルトを超えるものであって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(b) those with a rated voltage exceeding 750 volts, which fall under the following clauses 1. and 2.:

（一）　公称静電容量が〇・二五マイクロファラドを超えるもの

1. those whose nominal capacitance exceeds 0.25 microfarads;

（二）　直列インダクタンスが一〇ナノヘンリー未満のもの

2. those whose series inductance is less than 10 nanohenries;

五十　パルス発生器又はキセノンせん光ランプの発光装置であって、次のいずれかに該当するもの

(l) pulse generators or xenon flashlamp drivers, which fall under any of the following devices:

イ　モジュール方式のパルス発生器又はキセノンせん光ランプの発光装置であって、次の全てに該当するもの

(a) modular pulse generators or xenon flashlamp drivers, which fall under all of the following clauses:

（一）　四〇オーム未満の抵抗負荷に対して一五マイクロ秒未満の時間でパルスを供給することができるもの

1. those capable of supplying a pulse for less than 15 microseconds against a resistance load of less than 40 ohms;

（二）　出力が一〇〇アンペアを超えるもの

2. those with an output exceeding 100 amperes;

（三）　寸法の最大値が三〇センチメートル以下のもの

3. those whose largest value of dimension is 30 centimeters or less;

（四）　重量が三〇キログラム未満のもの

4. those with a weight of less than 30 kilograms;

（五）　零下五〇度より低い温度から一〇〇度を超える温度まで用いることができるように設計したもの又は宇宙で用いることができるように設計したもの

5. those that are designed to be used at a temperature of below minus 50 degrees centigrade to over 100 degrees centigrade, or designed to be used in space;

ロ　パルス発生器又はパルスヘッドであって、五五オーム未満の抵抗負荷に対して六ボルトを超える電圧のパルスを発生し、かつ、五〇〇ピコ秒未満のパルス立上がり時間を要するもの（イに該当するものを除く。）

(b) pulse generators or pulse heads, which generate pulses with a voltage exceeding 6 volts against a resistance load of less than 55 ohms, and, require a pulse rise time of less than 500 picoseconds (excluding those that fall under sub-item (a));

五十一　雷管の部分品であって、次の全てに該当するもの

(li) components of detonators which fall under all of the following sub-items:

イ　電気信号により火薬類の起爆を制御することができるもの

(a) those capable of controlling the ignition of explosives through electric signals;

ロ　ストリップラインの構造を有するもの

(b) those that have a stripline structure;

ハ　定格電圧が二キロボルトを超えるもの

(c) those with a rated voltage exceeding 2 kilovolts;

ニ　インダクタンスパスが二〇ナノヘンリー未満のもの

(d) those with an inductance path of less than 20 nanohenries;

五十二　光電子増倍管であって、光電陰極の面積が二〇平方センチメートルを超えるもののうち、陽極パルス立上がり時間が一ナノ秒未満のもの

(lii) among photomultiplier tubes with an area of photocathode that exceeds 20 square centimeters, those with an anode pulse rise time of less than 1 nanosecond;

五十三　トリチウム又は重水素と重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装

置であって、次のいずれかに該当するもの

(liii) neutron generators that use electrostatic acceleration induced by a tritium-deuterium nuclear reaction or deuterium-deuterium nuclear reaction, which fall under either of the following sub-items:

イ　トリチウムと重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置であって、真空ポンプを使用しないで操作できるように設計したもの

(a) neutron generators that use electrostatic acceleration induced by a tritium-deuterium nuclear reaction, which are designed to be capable of operating without using a vacuum pump; or

ロ　重水素と重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置であって、一秒につき三ギガ以上の中性子を生産できるもののうち、真空ポンプを使用しないで操作できるように設計したもの

(b) among neutron generators that use electrostatic acceleration induced by a deuterium-deuterium nuclear reaction which are capable of producing neutrons with 3 gigahertz or more per second, those that are designed to be capable of operating without using a vacuum pump;

五十四　放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーターであって、厚さ〇・六メートル以上の放射線を遮へいする壁を隔てて操作することができるもの

(liv) remote control manipulators to be used for preventing radioation exposure, which may be operated from the other side of a radiation shielding wall with a thickness of 0.6 meters or more;

五十五　放射線を遮へいするように設計した窓であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその窓枠

(lv) windows that are designed to shield radiation, which fall under all of the following sub-items (a) through (c), or their frames:

イ　コールドエリア側に露出する面の面積が〇・〇九平方メートルを超えるもの

(a) windows with an area exceeding 0.09 square meters for the surface that protrudes into the cold area;

ロ　密度が一立方センチメートル当たり三グラムを超える材料を用いたもの

(b) windows made from materials with a density exceeding 3 grams per cubic centimeter;

ハ　厚さが一〇〇ミリメートル以上のもの

(c) windows with a thickness of 100 millimeters or more;

五十六　放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ又はそのレンズであって、全吸収線量がシリコン換算で五〇、〇〇〇グレイを超える放射線照射に耐えることができるもの

(lvi) TV cameras designed to protect the influence of radiation, or their lenses, which are capable of withstanding radiation with the total absorbed dose exceeding 50,000 grays on a silicon basis;

五十七　トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物であって、トリチウム

の原子数の水素の原子数に対する比率が一、〇〇〇分の一を超えるもの（装置に内蔵されたものであって、一装置当たりの放射能の総量が一、四八〇ギガベクレル未満のものを除く。）

(lvii) tritium, tritium compounds, or tritium mixtures, with a ratio of the number of atoms of tritium to the number of atoms of hydrogen which exceeds 1/1,000 (excluding those installed in devices, with the total radioactivity per device of less than 1,480 gigabecquerels);

五十八　トリチウムの製造、回収若しくは貯蔵に用いられる装置又はトリチウムの製造に用いられる装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(lviii) devices used for the production, collection or storage of tritium, or components of equipment used for the production of tritium, which fall under either of the following sub-items:

イ　トリチウムの製造用（濃縮用を含む。）、回収用又は貯蔵用に設計した装置

(a) devices that are designed for the production (including those used for concentration), collection, or preservation of tritium;

ロ　トリチウムの製造（精製を含む。）、回収又は貯蔵に用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの（イに該当するものを除く。）

(b) devices used for the production (including purification), collection, or preservation of tritium, which fall under any of the following clauses (excluding those that fall under sub-item (a)):

（一）　水素又はヘリウムを零下二五〇度以下の温度に冷却することができる冷凍装置であって、冷凍能力が一五〇ワットを超えるもの

1. refrigeration devices capable of cooling hydrogen or helium to minus 250 degrees centigrade or less, with a freezing capacity exceeding 150 watts;

（二）　水素の同位元素の貯蔵用又は精製用の装置であって、金属水素化物を貯蔵又は精製のための媒体として用いるもの

2. devices for the storage or purification of hydrogen isotopes, which uses metal hydrides as storage or purification catalysts;

ハ　トリチウムの製造に用いられる装置であって、照射（原子炉内における照射を含む。）によりトリチウムを製造するために特に設計したリチウム（リチウム六の同位体が濃縮されているものに限る。）を含有する標的となる組立品（イ及びロに該当するものを除く。）

(c) devices used for the production of tritium which is an assembly (excluding one that fall under sub-items (a) and (b)) targeted to contain lithium (limited to those in which isotopes of lithium 6 have been enriched) which are specially designed to produce tritium by irradiation (including irradiation in a nuclear reactor); or

ニ　トリチウムの製造に用いられる装置の部分品であって、ハに該当する貨物のために特に設計した部分品

(d) components of devices used for the production of tritium, which are specially designed for the goods that fall under sub-item (c);

五十九　重水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒であって、水素と水との間で行われる水素の同位体交換を促進するために設計したもの

(lix) catalysts using platinum for collecting tritium from heavy water, or for producing heavy water, which are designed to promote isotope exchange of hydrogen conducted between hydrogen and water;

六十　ヘリウム三の混合率が天然の混合率を超えるヘリウム（容器又は装置に密封されたヘリウム三であって、その重量が一グラム未満のものを除く。）

(lx) helium with a mixing rate of helium-3 that is greater than the mixing rate in nature (excluding helium-3 sealed in containers or devices, with a weight of less than 1 gram);

六十一　レニウム、レニウムの含有量が全重量の九〇パーセント以上の合金又はレニウム及びタングステンの含有量が全重量の九〇パーセント以上の合金であって、質量が二〇キログラムを超え、かつ、内径が一〇〇ミリメートル超三〇〇ミリメートル未満の円筒形のもの若しくは中空の半球形のもの又はこれらを組み合わせたもの

(lxi) rhenium, alloys with a rhenium content of 90% or more of the total weight, or alloys with a content of rhenium or tungsten of 90% or more of the total weight, with a mass exceeding 20 kilograms, and, has a cylindrical shape with an internal diameter exceeding 100 millimeters and less than 300 millimeters or has a hemispherical shape and hollow, or their combination;

六十二　防爆構造の容器であって、爆発物又は爆発装置の試験に用いるために設計されたもののうち、次のイ及びロに該当するもの

(lxii) among explosion-proof containers that are designed to be used for testing explosives or explosive devices, those falling under the following sub-items (a) and (b):

イ　トリニトロトルエン二キログラム以上と同等の爆発を十分に封じ込めるように設計したもの

(a) those designed to be capable of fully containing explosions equivalent to 2 kilograms or more of trinitrotoluene; and

ロ　当該試験による分析情報又は測定情報を伝達することができる構造又は特性を有するもの

(b) those that have a structure or characteristics capable of transmitting analysis information or measurement information of the tests.

第二条　輸出令別表第一の三の項（一）の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 2 (1) The goods specified by the Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 3 (i) of the Appended Table 1 of the Export Order are substances that fall under any of the following items:

一　軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であって、いずれかの物質の含有量が全重量の三〇パーセン

トを超えるもの

(i) substances that fall under any of the following sub-items as those that are to be raw materials of chemical preparations for military purposes, or mixtures containing those substances, for which the content of any of the substances exceeds 30 % of the total weight:

イ　三―ヒドロキシ―一―メチルピペリジン

(a) 3-hydroxy-1-methylpiperidine;

ロ　フッ化カリウム

(b) potassium fluoride;

ハ　エチレンクロロヒドリン

(c) ethylene chlorohydrin;

ニ　ジメチルアミン

(d) dimethylamine;

ホ　塩酸ジメチルアミン

(e) dimethylamine hydrochloride;

ヘ　フッ化水素

(f) hydrogen fluoride;

ト　ベンジル酸メチル

(g) methyl benzilate;

チ　三―キヌクリジノン

(h) 3-quinuclidinone;

リ　ピナコロン

(i) pinacolone;

ヌ　シアン化カリウム

(j) potassium cyanide;

ル　一水素二フッ化カリウム

(k) potassium bifluoride;

ヲ　一水素二フッ化アンモニウム

(l) ammonium bifluoride;

ワ　一水素二フッ化ナトリウム

(m) sodium bifluoride;

カ　フッ化ナトリウム

(n) sodium fluoride;

ヨ　シアン化ナトリウム

(o) sodium cyanide;

タ　五硫化リン

(p) phosphorous pentasulfide;

レ　ジイソプロピルアミン

(q) diisopropylamine;

ソ　二―ジエチルアミノエタノール

(r) 2-diethylamino ethanol;

ツ　硫化ナトリウム
(s) sodium sulfide;
ネ　トリエタノールアミン塩酸塩
(t) triethanolamine hydrochloride;
ナ　亜リン酸トリイソプロピル
(u) phosphorous acid triisopropyl;
ラ　ジエチルチオリン酸
(v) diethyl thiophosphoric acid;
ム　ジエチルジチオリン酸
(w) diethyl dithio phosphoric acid;
ウ　ヘキサフルオロケイ酸ナトリウム
(x) sodium hexafluorosilicic acid;
ヰ　ジエチルアミン
(y) diethylamine;
ノ　メチルホスホロジクロリダート
(z) methyl dichlorophosphate;
オ　エチルホスホロジクロリダート
(aa) ethyl dichlorophosphate;
ク　メチルホスホロジフロリダート
(bb) methyl difluorophosphate;
ヤ　エチルホスホロジフロリダート
(cc) ethyl difluorophosphate;
マ　ジエチルクロロホスファイト
(dd) diethyl chlorophosphite;
ケ　クロロフルオロメチルホスフェート
(ee) methyl chlorofluorophosphate;
フ　クロロフルオロエチルホスフェート
(ff) ethyl chlorofluorophosphate;
コ　N・N－ジメチルホルムアミジン
(gg) N,N-dimethylformamidine;
エ　N・N－ジエチルホルムアミジン
(hh) N,N-diethylformamidine;
テ　N・N－ジプロピルホルムアミジン
(ii) N,N-dipropylformamidine;
ア　N・N－ジイソプロピルホルムアミジン
(jj) N,N-diisopropylformamidine;
サ　N・N－ジメチルアセトアミジン
(kk) N,N-dimethylacetamidine;
キ　N・N－ジエチルアセトアミジン
(ll) N,N-diethylacetamidine;
ユ　N・N－ジプロピルアセトアミジン

(mm) N,N-dipropylacetamidine;
メ　N・N－ジメチルプロパノアミジン
(nn) N,N-dimethylpropanamidine;
ミ　N・N－ジエチルプロパノアミジン
(oo) N,N-diethylpropanamidine;
シ　N・N－ジプロピルプロパノアミジン
(pp) N,N-dipropylpropanamidine;
ヱ　N・N－ジメチルブタノアミジン
(qq) N,N-dimethylbutanamidine;
ヒ　N・N－ジエチルブタノアミジン
(rr) N,N-diethylbutanamidine;
モ　N・N－ジプロピルブタノアミジン
(ss) N,N-dipropylbutanamidine;
セ　N・N－ジイソプロピルブタノアミジン
(tt) N,N-diisopropylbutanamidine;
ス　N・N－ジメチルイソブタノアミジン
(uu) N,N-dimethylisobutanamidine;
ン　N・N－ジエチルイソブタノアミジン
(vv) N,N-diethylisobutanamidine;
イイ　N・N－ジプロピルイソブタノアミジン
(ww) N,N-dipropylisobutanamidine;

二　軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物（イからトまでに該当する物質を含む混合物にあっては、イからハまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の一パーセントを超えるもの又はニからトまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の三〇パーセントを超えるものに限る。）

(ii) substances falling under any of the following sub-items as those that have a toxicity equivalent to chemical preparations for military purposes, or mixtures containing those substances (for mixtures containing a substance that fall under sub-items (a) through (g), limited to those for which the content of any substance that fall under sub-items (a) through (c) exceeds 1% of the total weight, or those for which the content of any substance that fall under any of the sub-items (d) through (g) exceeds 30 % of the total weight):

イ　O・O―ジエチル＝S―［二―（ジエチルアミノ）エチル］＝ホスホロチオラート並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
(a) O,O-diethyl=S-[2-(diethylamino)ethyl] = phosphorothiolate and alkylate salts and protonate salts thereof;
ロ　一・一・三・三・三―ペンタフルオロ―二―（トリフルオロメチル）―一―プロペン
(b) 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-1-propane;
ハ　三―キヌクリジニル＝ベンジラート

(c) 3-quinuclidinyl = benzilate;

ニ　二塩化カルボニル

(d) carbonyl dichloride;

ホ　塩化シアン

(e) cyanogen chloride;

ヘ　シアン化水素

(f) hydrogen cyanide; or

ト　トリクロロニトロメタン

(g) trichloronitromethane;

三　軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物（へからヤまでに該当する物質を含む混合物にあっては、へからタまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の一〇パーセントを超えるもの又はレからヤまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の三〇パーセントを超えるものに限る。）

(iii) substances falling under any of the following sub-items as those that have a toxicity equivalent to chemical preparations for military purposes, or mixtures containing those substances (for mixtures containing substances that fall under sub-items (f) through (cc), limited to those for which the content of any substance that fall under sub-items (f) through (p) exceeds 10 % of the total weight, or those for which the content of any substance that fall under sub-items (f) through (cc) exceeds 30% of the total weight):

イ　アルキルホスホニルジフルオリド（アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。）

(a) alkyl phosphonyl difluoride (limited to those that have an alkyl group carbon number of 3 or less);

ロ　O―アルキル＝O―二―ジアルキルアミノエチル＝アルキルホスホニット（O―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O―アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、O―二―ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。）並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類

(b) O-alkyl = O-2-dialkylaminoethyl = alkyl phosphonite (including those with alkyl group of O-alkyl is cycloalkyl group and limited to those with the number of carbon for alkyl group of O-alkyl is 10 or less, and, the number of carbon for alkyl group of O-2-dialkylaminoethyl or alkyl phosphonite is 3 or less) as well as their alkylate salts and protonate salts;

ハ　O―二―ジアルキルアミノエチル＝ヒドロゲン＝アルキルホスホニット（O―二―ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。）並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類

(c) O-2-dialkylaminoethyl = hydrogen = alkyl phosphonite (limited to those for which the number of carbon for alkyl group of O-2-dialkylaminoethyl or alkyl phosphonite is 3 or less) as well as their alkylate salts and protonate

salts;
ニ　O―イソプロピル＝メチルホスホノクロリダート
(d) O-isopropyl = methyl phosphonochloridate;
ホ　O―ピナコリル＝メチルホスホノクロリダート
(e) O-pinacolyl = methyl phosphonochloridate;
ヘ　炭素数が三以下である一のアルキル基との結合以外に炭素原子との結合のないりん原子を含む化合物
(f) compounds containing a phosphorus atom that have no bond with a carbon atom other than a bond with one alkyl group for which the number of carbon is 3 or less;
ト　N・N―ジアルキルホスホルアミジク＝ジハリド（アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。）
(g) N,N-dialkyl phosphoramidic = dihalide (limited to those with the number of carbon for alkyl group is 3 or less);
チ　ジアルキル＝N・N―ジアルキルホスホルアミダート（ジアルキル及びN・N―ジアルキルホスホルアミダートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。）
(h) dialkyl = N,N-dialkyl phosphoramidate (limited to those with the number of carbon for alkyl group of dialkyl or N,N-dialkyl phosphoramidateis 3 or less);
リ　三塩化ヒ素
(i) arsenic trichloride;
ヌ　二・二―ジフェニル―二―ヒドロキシ酢酸
(j) 2,2-diphenyl-2-hydroxyacetic acid;
ル　キヌクリジン―三―オール
(k) quinuclidine-3-ol;
ヲ　N・N―ジアルキルアミノエチル―二―クロリド（アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。）及びそのプロトン化塩類
(l) N,N-dialkylaminoethyl-2-chloride (limited to those with the number of carbon for alkyl group is 3 or less) and their protonate salts;
ワ　N・N―ジアルキルアミノエタン―二―オール（アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。）及びそのプロトン化塩類
(m) N,N-dialkyl aminoethane-2-ol (limited to those with the number of carbon for alkyl group is 3 or less) and their protonate salts;
カ　N・N―ジアルキルアミノエタン―二―チオール（（アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。二―ジイソプロピルアミノエタンチオールを含む。）及びそのプロトン化塩類（二―ジイソプロピルアミノエタンチオール塩酸塩を含む。）
(n) N,N-dialkyl aminoethane-2-thiol ((limited to those with the number of carbon for alkyl group is 3 or less; and including 2-diisopropylamino ethanethiol) and their protonated salts (including 2-diisopropylamino

ethanethiol hydrochloride);
ヨ　ビス（二―ヒドロキシエチル）スルフィド
(o) bis(2-hydroxyethyl) sulfide;
タ　三・三―ジメチルブタン―二―オール
(p) 3,3-dimethylbutane-2-ol;
レ　塩化ホスホリル
(q) phosphoryl chloride;
ソ　三塩化リン
(r) phosphorous trichloride;
ツ　五塩化リン
(s) phosphorous pentachloride;
ネ　亜リン酸トリメチル
(t) trimethyl phosphite;
ナ　亜リン酸トリエチル
(u) triethyl phosphite;
ラ　亜リン酸ジメチル
(v) dimethyl phosphite;
ム　亜リン酸ジエチル
(w) diethyl phosphite;
ウ　一塩化硫黄
(x) sulfur monochloride;
ヰ　二塩化硫黄
(y) sulfur bichloride;
ノ　塩化チオニル
(z) thionyl chloride;
オ　エチルジエタノールアミン
(aa) ethyl diethanol amine;
ク　メチルジエタノールアミン
(bb) methyl diethanol amine;
ヤ　トリエタノールアミン
(cc) triethanolamine.

2　輸出令別表第一の三の項（二）の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

(2) The goods with specifications prescribed by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 3 (ii) of the Appended Table 1 of the Export Order are those that fall under any of the following items:

一　反応器であって、容量が〇・一立方メートル超二〇立方メートル未満のもののうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

(i) among reactors that have a capacity exceeding 0.1 cubic meters and less than 20 cubic meters, those for which all the parts that come into contact

with the contents are composed of, lined with, or coated with materials falling under any of the following sub-items:

イ　ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金

(a) nickel or alloys with a nickel content exceeding 40 % of the total weight;

ロ　ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金

(b) alloys with a nickel content exceeding 25 % of the total weight and a chrome content exceeding 20 % of the total weight;

ハ　ふっ素重合体

(c) fluoropolymers;

ニ　ガラス

(d) glass;

ホ　タンタル又はタンタル合金

(e) tantalum or tantalum alloys;

ヘ　チタン又はチタン合金

(f) titanium or titanium alloys;

ト　ジルコニウム又はジルコニウム合金

(g) zirconium or zirconium alloys; or

チ　ニオブ又はニオブ合金

(h) niobium or niobium alloys;

二　貯蔵容器であって、容量が〇・一立方メートルを超えるもののうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

(ii) among the storage containers having a capacity exceeding 0.1 cubic meters, those for which all the parts that come into contact with the contents are composed of, lined with, or coated with materials falling under any of the following sub-items:

イ　ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金

(a) nickel or alloys with a nickel content exceeding 40 % of the total weight;

ロ　ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金

(b) alloys with a nickel content exceeding 25 % of the total weight and chrome content exceeding 20 % of the total weight;

ハ　ふっ素重合体

(c) fluoropolymers;

ニ　ガラス

(d) glass;

ホ　タンタル又はタンタル合金

(e) tantalum or tantalum alloys;

ヘ　チタン又はチタン合金

(f) titanium or titanium alloys;

ト　ジルコニウム又はジルコニウム合金

(g) zirconium or zirconium alloys; or

チ　ニオブ又はニオブ合金

(h) niobium or niobium alloys;

三　熱交換器若しくは凝縮器であって、伝熱面積が〇・一五平方メートル超二〇平方メートル未満のもの又はこれらの部分品として設計されたチューブ、プレート、コイル若しくはブロックのうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

(iii) among heat exchangers or condensers having an area of heat transfer surface exceeding 0.15 square meters and less than 20 square meters, or tubes, plates, coils, or blocks that are designed as their components, those for which all the parts that come into contact with the contents are composed of, lined with, or coated with materials falling under any of the following sub-items:

イ　ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金

(a) nickel or alloys with a nickel content exceeding 40% of the total weight;

ロ　ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金

(b) alloys with a nickel content exceeding 25% of the total weight and chrome content exceeding 20% of the total weight;

ハ　ふっ素重合体

(c) fluoropolymers;

ニ　ガラス

(d) glass;

ホ　黒鉛又はカーボングラファイト

(e) graphite or carbon graphite;

ヘ　タンタル又はタンタル合金

(f) tantalum or tantalum alloys;

ト　チタン又はチタン合金

(g) titanium or titanium alloys;

チ　ジルコニウム又はジルコニウム合金

(h) zirconium or zirconium alloys;

リ　炭化けい素

(i) silicon carbide;

ヌ　炭化チタン

(j) titanium carbide; or

ル　ニオブ又はニオブ合金

(k) niobium or niobium alloys;

四　蒸留塔若しくは吸収塔であって、塔の内径が〇・一メートルを超えるもの又はこれらの部分品として設計された液体分配器、蒸気分配器若しくは液体収集器のうち、内容物と接触する全ての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちさ

れ、又は被覆されたもの

(iv) among distillation columns or absorption columns that has an internal diameter exceeding 0.1 meter, or liquid dispensers, vapor dispensers, or liquid collectors that are designed as their components, those for which all of the parts that come into contact with the contents are composed of, lined with, or coated with materials falling under any of the following sub-items:

イ　ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金

(a) nickel or alloys with a nickel content exceeding 40 % of the total weight;

ロ　ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金

(b) alloys with a nickel content exceeding 25 % of the total weight and a chrome content exceeding 20 % of the total weight;

ハ　ふっ素重合体

(c) fluoropolymers;

ニ　ガラス

(d) glass;

ホ　黒鉛又はカーボングラファイト

(e) graphite or carbon graphite;

ヘ　タンタル又はタンタル合金

(f) tantalum or tantalum alloys;

ト　チタン又はチタン合金

(g) titanium or titanium alloys;

チ　ジルコニウム又はジルコニウム合金

(h) zirconium or zirconium alloys;

リ　ニオブ又はニオブ合金

(i) niobium or niobium alloys;

五　充てん用の機械であって、遠隔操作が可能であり、かつ、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

(v) filling machines that can be remote controlled, and, for which all of the parts that come into contact with the contents are composed of, lined with or coated with materials falling under any of the following sub-items:

イ　ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金

(a) nickel or alloys with a nickel content exceeding 40% of the total weight;

ロ　ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金

(b) alloys with a nickel content exceeding 25% of the total weight and a chrome content exceeding 20% of the total weight;

六　かくはん機であって、第一号に該当するものに用いるように設計されたもの又はその部分品として設計されたインペラー、ブレード若しくはシャフトのうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、

又は被覆されたもの

(vi) among agitators that are designed to be used for the things falling under item (i), or impellers, blades, or shafts designed as the components, those for which all the parts that come into contact with the contents are composed of, lined with, or coated with materials falling under any of the following sub-items:

イ　ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金

(a) nickel or alloys with a nickel content exceeding 40% of the total weight;

ロ　ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金

(b) alloys with a nickel content exceeding 25% of the total weight and chrome content exceeding 20% of the total weight;

ハ　ふっ素重合体

(c) fluoropolymers;

ニ　ガラス

(d) glass;

ホ　タンタル又はタンタル合金

(e) tantalum or tantalum alloys;

ヘ　チタン又はチタン合金

(f) titanium or titanium alloys;

ト　ジルコニウム又はジルコニウム合金

(g) zirconium or zirconium alloys; or

チ　ニオブ又はニオブ合金

(h) niobium or niobium alloys;

七　弁又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(vii) valves or their components which fall under any of the following sub-items:

イ　呼び径が一〇A超の弁であって、内容物と接触する全ての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

(a) valves whose nominal diameter is over 10 A for which all of the parts that come into contact with the contents are composed of, lined with, or coated with materials falling under any of the following clauses:

（一）　ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金

1. nickel or alloys with a nickel content exceeding 40% of the total weight;

（二）　ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金

2. alloys with a nickel content exceeding 25% of the total weight and a chrome content exceeding 20% of the total weight;

（三）　ふっ素重合体

3. fluoropolymers;

（四）　ガラス

4. glass;

（五）　タンタル又はタンタル合金

5. tantalum or tantalum alloys;

（六）　チタン又はチタン合金

6. titanium or titanium alloys;

（七）　ジルコニウム又はジルコニウム合金

7. zirconium or zirconium alloys;

（八）　ニオブ又はニオブ合金

8. niobium or niobium alloys; or

（九）　セラミックであって、次のいずれかに該当するもの

9. ceramics that fall under any of the following clauses:

１　炭化けい素の含有量が全重量の八〇パーセント以上のもの

i. those with a silicon carbide content of 80% or more of the total weight;

２　酸化アルミニウムの含有量が全重量の九九・九パーセント以上のもの

ii. those with an aluminum oxide content of 99.9% or more of the total weight; or

３　酸化ジルコニウム

iii. zirconium oxide;

ロ　呼び径が二五Ａ以上一〇〇Ａ以下の弁であって、次の全てに該当するもの（イに該当するものを除く。）

(b) valves with a nominal diameter of over 25 A and less than 100 A, which fall under all of the following clauses (excluding those that fall under sub-item (a)):

（一）　閉止部分以外のケーシング又はケーシングライナーのうち、内容物と接触する全ての部分がイ（一）から（九）までで定めたいずれかの材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

1. among casings or casing liners for parts other than shut-off parts, those for which all of the parts that come into contact with the contents are composed of, or lined with, or coated with any of the materials specified in sub-item (a), clauses 1. through 9.; and

（二）　閉止部分が交換可能なように設計されたもの

2. those whose shut-off parts are designed to be exchangeable;

ハ　イ又はロに該当する弁の部分品として設計されたケーシング又はケーシングライナーであって、内容物と接触する全ての部分がイ（一）から（九）までで定めたいずれかの材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

(c) casings or casing liners designed as components for the valves that fall under sub-item (a) or (b) for which all of the parts that come into contact with the contents are composed of, or lined with, or coated with any of the materials specified in sub-item (a), clauses 1. through 9.

八　内容物の漏れを検知する装置の取付口が設けられている多重管であって、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、

又は被覆されたもの

(viii) multipe tubes provided with a mounting port for devices used for detecting leaks of contents for which all of the parts that come into contact with the contents are composed of, lined with, or coated with materials falling under any of the following sub-items:

イ　ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金

(a) nickel or alloys with a nickel content exceeding 40% of the total weight;

ロ　ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金

(b) alloys with a nickel content exceeding 25% of the total weight and chrome content exceeding 20% of the total weight;

ハ　ふっ素重合体

(c) fluoropolymers;

ニ　ガラス

(d) glass;

ホ　黒鉛又はカーボングラファイト

(e) graphite or carbon graphite;

ヘ　タンタル又はタンタル合金

(f) tantalum or tantalum alloys;

ト　チタン又はチタン合金

(g) titanium or titanium alloys;

チ　ジルコニウム又はジルコニウム合金

(h) zirconium or zirconium alloys; or

リ　ニオブ又はニオブ合金

(i) niobium or niobium alloys;

九　二重以上のシールで軸封をしたポンプ若しくはシールレスポンプであって最高規定吐出し量が一時間につき〇・六立方メートルを超えるもの若しくは真空ポンプであって最高規定吐出し量が一時間につき五立方メートルを超えるもの又はこれらの部分品として設計されたケーシング、ケーシングライナー、インペラー、ローター若しくはジェットポンプノズルのうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

(ix) among pumps that are shaft sealed by two or more layers of seals or seal-less pumps with the maximum prescribed discharge quantity that exceeds 0.6 cubic meters per hour or vacuum pumps with the maximum prescribed discharge quantity that exceeds 5 cubic meters per hour, or casings, casing liners, impellers, rotors, or jet pump nozzles designed as their components, those for which all the parts that come into contact with the contents are composed of, lined with, or coated with materials falling under any of the following substances:

イ　ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金

(a) nickel or alloys with a nickel content exceeding 40% of the total weight;

ロ　ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金

(b) alloys with a nickel content exceeding 25% of the total weight and a chrome content exceeding 20% of the total weight;

ハ　ふっ素重合体

(c) fluoropolymers;

ニ　ガラス

(d) glass;

ホ　黒鉛又はカーボングラファイト

(e) graphite or carbon graphite;

ヘ　タンタル又はタンタル合金

(f) tantalum or tantalum alloys;

ト　チタン又はチタン合金

(g) titanium or titanium alloys;

チ　ジルコニウム又はジルコニウム合金

(h) zirconium or zirconium alloys;

リ　セラミック

(i) ceramic;

ヌ　フェロシリコン

(j) ferrosilicon; or

ル　ニオブ又はニオブ合金

(k) niobium or niobium alloys;

十　焼却装置であって、使用中における燃焼室の平均温度が一、〇〇〇度を超えるもののうち、焼却する物質を供給する部分について内容物と接触する全ての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、又は被覆されたもの

(x) among incineration equipement with an average temperature of incineration chamber during use which exceeds 1,000 degrees centigrade, those for which all of the parts that come into contact with the contents for the parts that supply substances to be incinerated are composed of, or coated with, materials falling under any of the following sub-items:

イ　ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金

(a) nickel or alloys with a nickel content exceeding 40 % of the total weight;

ロ　ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金

(b) alloys with a nickel content exceeding 25 % of the total weight and a chrome content exceeding 20 % of the total weight; or

ハ　セラミック

(c) ceramic;

十一　空気中の物質を検知する装置であって、次のいずれかに該当するもの

(xi) detectors of substances in the air which fall under any of the following devices:

イ　前項に掲げるものについて空気中における濃度が一立方メートル当たり〇・三ミリグラム未満であっても検知することができるものであり、かつ、連続して使用するように設計したもの

(a) those capable of detecting substances stated in the preceding paragraph even when their concentration in the air is less than 0.3 milligrams per cubic meter, and, which are designed for continuous use; or

ロ　アンチコリンエステラーゼ作用を有する化合物を検知するように設計したもの

(b) those designed for detecting compounds having an anticholinesterase effect;

十二　前号に掲げるものの部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(xii) components of those substances stated in the preceding item, which fall under any of the following devices:

イ　検出器

(a) detectors;

ロ　センサーデバイス

(b) sensor devices; or

ハ　センサーカートリッジ

(c) sensor cartridges.

3　輸出令別表第一の三の項（三）の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

(3) The goods with the specifications prescribed by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row (3), (iii) of the Appended Table 1 of the Export Order are those that fall under either of the following items:

一　前項第一号に該当する反応器のうち、内容物と接触する全ての部分がガラスで裏打ちされ、又は被覆されたものの修理に用いられる組立品又はそのために特に設計した部分品であって、内容物と接触する金属部分がタンタル又はタンタル合金で構成されたもの

(i) among the reactors falling under item (i) of the preceding paragraph, assemblies used for repairing those with all of the parts that come into contact with the contents are lined or coated with glass, or components specially designed for that purpose for which the metal parts that come into contact with the contents are composed of tantalum or tantalum alloy; or

二　前項第二号に該当する貯蔵容器のうち、内容物と接触する全ての部分がガラスで裏打ちされ、又は被覆されたものの修理に用いられる組立品又はそのために特に設計した部分品であって、内容物と接触する金属部分がタンタル又はタンタル合金で構成されたもの

(ii) among the storage containers falling under item (ii) of the preceding paragraph, assemblies used for repairing those with all of the parts that come into contact with the contents are lined or coated with glass, or components specially designed for that purpose for which the metal parts that come into contact with the contents are composed of tantalum or

tantalum alloy.

第二条の二　輸出令別表第一の三の二の項（一）の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 2-2 (1) The goods specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 3-2 (i) of the Appended Table 1 of the Export Order are those that fall under any of the following items:

一　ウイルス（ワクチンを除く。）であって、アフリカ馬疫ウイルス、アフリカ豚熱ウイルス、アンデアン・ポテト・ラテント・ウイルス、アンデスウイルス、エボラウイルス属の全てのウイルス、黄熱ウイルス、オムスク出血熱ウイルス、オロポーチウイルス、ガナリトウイルス、キャサヌール森林病ウイルス、牛疫ウイルス、クリミア・コンゴ出血熱ウイルス、口蹄疫ウイルス、高病原性鳥インフルエンザウイルス（Ｈ五又はＨ七のＨ抗原を有するものに限る。）、ＳＡＲＳコロナウイルス、再構成一九一八年インフルエンザウイルス、サビアウイルス、サル痘ウイルス、小反芻獣疫ウイルス、シンノンブレウイルス、水胞性口炎ウイルス、西部ウマ脳炎ウイルス、セントルイス脳炎ウイルス、ソウルウイルス、ダニ媒介脳炎ウイルス（極東型に限る。）、チクングニアウイルス、チャパレウイルス、跳躍病ウイルス、テュクロウイルス、痘瘡ウイルス、東部ウマ脳炎ウイルス、ドブラバーベルグレドウイルス、ニパウイルス、日本脳炎ウイルス、ニューカッスル病ウイルス、ハンタンウイルス、豚熱ウイルス、豚水胞病ウイルス、豚テシオウイルス、豚ヘルペスウイルス―１、フニンウイルス、ブルータングウイルス、ベネズエラウマ脳炎ウイルス、ヘンドラウイルス、ポテト・スピンドル・チュバー・ウィロイド、ポワッサンウイルス、マチュポウイルス、ＭＥＲＳコロナウイルス、マールブルグウイルス属の全てのウイルス、マレー渓谷脳炎ウイルス、ヤギ痘ウイルス、羊痘ウイルス、ラグナネグラウイルス、ラッサウイルス、ランピースキン病ウイルス、リッサウイルス属のウイルス（狂犬病ウイルスを含む。）、リフトバレー熱ウイルス、リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス、ルヨウイルス又はロシオウイルス

(i) virus (excluding vaccines) that is African horse sickness virus, African swine fever virus, Andean potato latent virus, Andes virus, all viruses of the Ebola virus genus, the yellow fever virus, Omsk hemorrhagic fever virus, Oropouche virus, Guanarito virus, Kyasanur Forest disease virus, the cattle plague virus, Crimean-Congo hemorrhagic fever virus, the foot-and-mouth disease virus, the highly pathogenic avian influenza virus (limited to those having an H antigen of H5 or H7), the SARS coronavirus, the reconstructed 1918 influenza virus, Sabia virus, the monkeypox virus, the virus for pseudorinderpest of small ruminants, Sin Nombre virus, the vesicular stomatitis virus, the western equine encephalitis virus, Saint Louis encephalitis virus, Seoul virus, the tick-borne encephalitis virus (limited to the Far Eastern type), Chikungunya virus, Chapare virus, the louping ill virus, Choclo virus, the smallpox virus, the eastern equine encephalitis virus, Dobrava-Belgrade virus, Nipah virus, Japanese encephalitis virus, Newcastle

disease virus, Hantan virus, the swine fever virus, the swine vesicular virus, the porcine teschovirus, Suid herpesvirus 1, Junin virus, the blue tongue virus, Venezuelan equine encephalitis virus, Hendra virus, the potato spindle tuber viroid, Powassan virus, Machupo virus, the MERS coronavirus, all viruses of the Marburgvirus genus, Murray Valley encephalitis virus, the goat pox virus, the sheep pox virus, Laguna Negra virus, Lassa virus, the lumpy skin disease virus, viruses of the Lyssavirus genus (including Rabies lyssavirus), Rift Valley fever virus, the lymphocytic choriomeningitis virus, Lujo virus, or Rocio virus;

二　細菌（ワクチンを除く。）であって、アルゲンチネンス菌（ボツリヌス神経毒素産生株に限る。）、ウェルシュ菌（イプシロン毒素産生型のものに限る。）、ウシ流産菌、オウム病クラミジア、牛肺疫菌（小コロニー型）、コクシエラ属バーネッティイ、コレラ菌、志賀赤痢菌、炭疽菌、チフス菌、腸管出血性大腸菌（血清型O二六、O四五、O一〇三、O一〇四、O一一一、O一二一、O一四五及びO一五七）、発疹チフスリケッチア、バラチ菌（ボツリヌス神経毒素産生株に限る。）、鼻疽菌、ブタ流産菌、ブチリカム菌（ボツリヌス神経毒素産生株に限る。）、ペスト菌、ボツリヌス菌、マルタ熱菌、山羊伝染性胸膜肺炎菌Ｆ三八株、野兎病菌又は類鼻疽菌

(ii) bacteria (excluding vaccines) that is Clostridium argentinense (limited to botulinum neurotoxin producing strains), Clostridium perfringens (limited to types producing epsilon toxins), Brucella abortus, Chlamydia psittaci, Mycoplasma mycoides (small colony type), Coxiella burnetii, the cholera bacillus, Shigella dysenteriae, Bacillus anthracis, the typhoid bacillus, enterohemorrhagic Escherichia coli (serotype O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, and O157), Rickettsia prowazekii, Clostridium baratii (limited to botulinum neurotoxin producing strains), Actinobacillus mallei, Brucella suis, Clostridium butyricum (limited to botulinum neurotoxin producing strains), Bacillus pestis, Bacillus botulinus, Brucella melitensis, Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae (strain F38), Bacillus tularensis, or Pseudomonas pseudomallei;

三　毒素（免疫毒素を除く。）であって、アフラトキシン、アブリン、ウェルシュ菌毒素（アルファ、ベータ１、ベータ２、イプシロン又はイオタの毒素に限る。）、ＨＴ―２トキシン、黄色ブドウ球菌毒素（腸管毒素、アルファ毒素及び毒素性ショック症候群毒素）、コノトキシン、コレラ毒素、志賀毒素、ジアセトキシスシルペノール、Ｔ―２トキシン、テトロドトキシン、ビスカミン、ボツリヌス毒素、ボルケンシン、ミクロシスチン又はモデシン

(iii) toxins (excluding immunotoxins) that is aflatoxin, abrin, clostridium welchii toxin (limited to alpha, beta 1, beta 2, epsilon, or iota toxin), HT-2 toxin, staphylococcal enterotoxin (enterotoxin, alpha-toxin, and toxic shock syndrome toxin), conotoxin, cholera toxin, Shiga toxin, diacetoxyscirpenol, T-2 toxin, tetrodotoxin, viscumin, botulin toxin, Volkensin, microcystin, or

modeccin;

四　前号に該当するもののサブユニット

(iv) subunits of those falling under the preceding item;

五　細菌又は菌類であって、クラビバクター・ミシガネンシス亜種セペドニカス、コクシジオイデス・イミチス、コクシジオイデス・ポサダシ、コクリオボールス・ミヤベアヌス、コレトトリクム・カーハワイ、ザントモナス・アクソノポディス・パソバー・シトリ、ザントモナス・アルビリネアンス、ザントモナス・オリゼ・パソバー・オリゼ、シンキトリウム・エンドビオチクム、スクレロフトラ・ライシアエ・バラエティー・ゼアエ、セカフォラ・ソラニ、チレチア・インディカ、プクシニア・グラミニス種グラミニス・バラエティー・グラミニス、プクシニア・ストリイフォルミス、ペロノスクレロスポラ・フィリピネンシス、マグナポルテ・オリゼ、ミクロシクルス・ウレイ又はラルストニア・ソラナセアルム・レース三及び次亜種二

(v) bacteria or fungi that is Clavibacter michiganensis subspecies sepedonicus, Coccidioides immitis, Coccidioides posadasii, Cochliobolus miyabeanus, Colletotrichum kahawae, Xanthomonas axonopodis pv. citri, Xanthomonas albilineans, Xanthomonas oryzae pv. oryzae, Synchytrium endobioticum, Sclerophthorarayssiae var.zeae, Thecaphora solani, Tilletia indica, Puccinia graminis variety graminis, Puccinia striiformis, Peronosclerospora philippinensis, Magnaporthe oryzae, Microcyclus ulei, or Ralstonia solanacearum race 3, or biovar 2;

六　遺伝子を改変した生物（意図的な分子操作によって核酸の塩基配列を生成し、又は改変されたものを含む。）であって次のいずれかを有するもの又は遺伝要素（染色体、ゲノム、プラスミド、トランスポゾン、ベクター及び復元可能な核酸断片を含む不活性化された組織体を含む。）であって次のいずれかの塩基配列を有するもの

(vi) genetically-modified organisms (including those for which the base sequence of their nucleic acid has been generated or modified by deliberate molecular manipulation) that have any of the following genes, or genetic elements (including inactivated organisms including chromosomes, genomes, plasmids, transposons, vectors, and recoverable nucleic acid fragments) that have any of the following base sequences:

イ　第一号に該当する遺伝子

(a) genes falling under item (i);

ロ　第二号又は前号に該当する遺伝子のうち、人、動物若しくは植物の健康に重大な危害を与えるもの（転写又は翻訳した生産物を通じて危害を与えるものを含む。）又は病原性を付与若しくは増強することができるもの（血清型O二六、O四五、O一〇三、O一〇四、O一一一、O一二一、O一四五、O一五七その他の志賀毒素を産生する血清型をもつ大腸菌の核酸の塩基配列（志賀毒素又はそのサブユニットの遺伝要素を持つものに限る。）を有するもの以外のものを除く。）

(b) among genes falling under item (ii) or the preceding item, those which

cause serious harm to the health of humans, animals, or plants (including those which cause harm through transcribed or translated products), or those capable of giving or increasing pathogenicity (excluding genes other than those that have base sequences of nucleic acid of Bacillus coli which have serotype O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157 or other serotypes that produce Shiga toxins (limited to base sequences that have genetic elements of Shiga toxins or their subunits)); or

ハ　第三号又は第四号に該当するもの

(c) those which fall under item (iii) or (iv).

2　輸出令別表第一の三の二の項（二）の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

(2) The goods with specifications prescribed by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 3-2 (ii) of the Appended Table 1 of the Export Order are those that fall under any of the following items:

一　物理的封じ込めに用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの

(i) devices used for physical containment which fall under either of the following sub-items:

イ　物理的封じ込めのレベルがＰ三又はＰ四の装置

(a) devices with a physical containment level of P3 or P4; or

ロ　物理的封じ込めのレベルがＰ三又はＰ四である施設に設置するよう設計された装置であって、次のいずれかに該当するもの

(b) devices designed to be installed in a facility with a physical containment level of P3 or P4, which fall under any of the following devices:

（一）　両面扉式の高圧蒸気滅菌装置

1. high-pressure steam sterilizers with double-sided doors;

（二）　防護服の汚染除去用のシャワー装置

2. shower device for decontaminating protective suits; or

（三）　機械的シール又は膨張式圧力シールを有する気密扉

3. airtight doors with a mechanical seal or inflatable pressure seal;

二　発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(ii) fermenters or their components, which fall under any of the following sub-items:

イ　使い捨て式以外の発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(a) fermenters or their components that are not disposable, which fall under any of the following devices:

（一）　内容積が二〇リットル以上の密閉式の発酵槽であって、定置した状態で内部の滅菌又は殺菌ができるもの

1. hermetically sealable fermenters with an inner capacity of 20 liters or more, which are capable of internal sterilization or disinfection in a fixed state;

（二）　（一）に該当する発酵槽に用いるように設計された培養容器であって、定置した状態で内部の滅菌又は殺菌ができるもの

2. culture vessels designed to be used for fermenters falling under clause 1. which are capable of internal sterilization or disinfection in a fixed state; or

（三）　（一）に該当する発酵槽に用いるように設計された制御装置であって、発酵装置を制御するための二以上のパラメーターを同時に監視及び制御をすることができるもの

3. control device designed to be used for fermenters falling under clause 1. which are capable of simultaneously monitoring and controlling two or more parameters for controlling fermentation equipment;

ロ　使い捨て式の発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(b) disposable fermenters or their components, which fall under any of the following devices:

（一）　内容積が二〇リットル以上の密閉式の発酵槽

1. hermetically sealed fermenters with an inner capacity of 20 liters or more;

（二）　（一）に該当する発酵槽に用いるように設計された使い捨て培養容器の収容装置

2. storage apparatus for disposable culture vessels that are designed to be used for fermenters that fall under clause 1.; or

（三）　（一）に該当する発酵槽に用いるように設計された制御装置であって、発酵装置を制御するための二以上のパラメーターを同時に監視及び制御をすることができるもの

3. control devices that are designed to be used for fermenters that fall under clause 1. which are capable of simultaneously monitoring and controlling two or more parameters for controlling fermentation equipment;

三　連続式の遠心分離機であって、次のイからニまでのすべてに該当するもの

(iii) continuous centrifuge separators falling under all of the following sub-items (a) through (d):

イ　流量が一時間につき一〇〇リットルを超えるもの

(a) those with a flow volume exceeding 100 liters per hour;

ロ　研磨したステンレス鋼又はチタンで構成されたもの

(b) those composed of polished stainless steel or titanium;

ハ　メカニカルシールで軸封をしているもの

(c) those that are shaft sealed with mechanical seals; and

ニ　定置し、かつ、閉じた状態で蒸気により内部の滅菌をすることができるもの

(d) those capable of internal sterilization using vapor in a fixed stated, and, in a closed state;

四　クロスフローろ過用の装置であって、次のイ及びロに該当するもの（逆浸透膜を

用いたもの及び血液の浄化を行うために設計したものを除く。）

(iv) cross flow filtration equipment falling under the following sub-items (a) and (b) (excluding those that use a reverse osmosis membrane and those that are designed to purify blood):

イ　有効ろ過面積の合計が一平方メートル以上のもの

(a) those with a total effective filtration area of 1 square meter or more; and

ロ　次の（一）又は（二）に該当するもの

(b) those that fall under the following clause 1. or 2.:

（一）　定置した状態で内部の滅菌又は殺菌をすることができるもの

1. those capable of internal sterilization or disinfection in a fixed state; or

（二）　使い捨ての部分品を使用するもの

2. those that use disposable components;

四の二　前号に掲げるものに使用するように設計した部分品であって、有効ろ過面積が〇・二平方メートル以上のもの

(iv)-2 components that are designed to be used for the equipment stated in the preceding item, with an effective filtration area of 0.2 square meters or more;

五　凍結乾燥器であって、次のイ及びロに該当するもの

(v) freeze-drying equipment falling under the following sub-items (a) and (b):

イ　二四時間につき一〇キログラム以上一、〇〇〇キログラム未満の氷を作る能力を有するもの

(a) those that have the capacity to create 10 kilograms or more and less than 1,000 kilograms of ice per 24 hours; and

ロ　蒸気又はガスにより内部の滅菌をすることができるもの

(b) those capable of internal sterilization using vapor or gas;

五の二　噴霧乾燥器であって、次のイからハまでの全てに該当するもの

(v)-2 spray dryers that fall under all of the following sub-items (a) through (c):

イ　水分蒸発量が一時間あたり〇・四キログラム以上四〇〇キログラム以下のもの

(a) those with a water evaporation amount of 0.4 kilograms or more and 400 kilograms or less per hour;

ロ　平均粒子径一〇マイクロメートル以下の製品を製造することが可能なもの又は噴霧乾燥器の最小の部分品の変更で平均粒子径一〇マイクロメートル以下の製品を製造することが可能なもの

(b) those capable of manufacturing products with an average particle diameter of 10 micrometers or less, or capable of producing products with an average particle diameter of 10 micrometers or less by replacing its smallest component; and

ハ　定置した状態で内部の滅菌又は殺菌をすることができるもの

(c) those capable of internal sterilization or disinfection in a fixed state;

六　物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置又は物理的封じ込めに用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの

(vi) protective equipment used in physical containment facilities, or devices

used for physical containment, which fall under any of the following sub-items:

イ　エアライン方式の換気用の装置を有する全身の若しくは半身の衣服又はフードであるもののうち、その内部を陽圧に維持することができるもの

(a) among clothes for the whole body or half the body or hoods with airline ventilation equipment, those capable of internally maintaining a positive pressure; or

ロ　物理的封じ込めチャンバー、アイソレータ又は安全キャビネットであって、次の全てに該当するもの（クラス―Ⅲ安全キャビネットを含み、感染患者の看護又は運搬のために特に設計されたものを除く。）

(b) physical containment chambers, isolators, or safety cabinets which fall under all of the following clauses 1. through 4. (including Class III safety cabinets and excluding those that are specially designed for nursing or transporting infected patients):

（一）　操作する者が物理的な防壁によって完全に隔離された作業空間を有するもの

1. those that have a working space in which the operating is completely isolated by a physical protective wall;

（二）　陰圧状態で操作することが可能なもの

2. those capable of being operated in a negative pressure state;

（三）　作業空間内で対象物を安全に操作するための手段を備えているもの

3. those equipped with means of operating an object safely in a working space; and

（四）　作業空間の給気及び排気にＨＥＰＡフィルターを用いるもの

4. those that use an HEPA filter for air supply and exhaustion in a working space;

七　粒子状物質の吸入の試験に用いるように設計された装置であって、次のいずれかに該当するもの

(vii) devices that are designed to be used for testing inhalation of particulate matters, which falls under either of the following sub-items:

イ　動物の全身を暴露することができる吸入室を有するものであって、吸入室の容積が一立方メートル以上のもの

(a) those that have an inhalation chamber capable of exposing the whole body of animals and have a volume of 1 cubic meter or more; or

ロ　一二以上のげっ歯類の動物又は二以上のげっ歯類以外の動物の鼻部を直接エアゾールを流動させて暴露することができるものであって、これに用いるように設計した動物を保定する密閉型のホルダーを有するもの

(b) those that are capable of exposing the noses of 12 or more rodents or two or more animals other than rodents by directly causing aerosol flow, having a hermetically sealable holder for immobilizing an animal which is designed to be used for that purpose; or

八　噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(viii) sprayers or fog machines, or their components, which fall under any of the following sub-items:

イ　航空機、飛行船、気球又は無人航空機に搭載するように設計した噴霧器又は煙霧機であって、初期粒径が体積メディアン径で五〇ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から二リットル毎分超の割合で散布できるもの

(a) sprayers or fog machines that are designed to be installed in aircraft, airships, balloons, or unmanned aircraft, which are capable of dispersing droplets with an initial particle size of less than 50 microns in volume median diameter from a device loaded with liquid at a rate exceeding 2 liters per minute;

ロ　航空機、飛行船、気球又は無人航空機に搭載するように設計したエアゾール発生装置のスプレーブーム又はノズルであって、初期粒径が体積メディアン径で五〇ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から二リットル毎分超の割合で散布できるもの

(b) a spray boom or nozzle of an aerosol generator that is designed to be installed in aircraft, airships, balloons, or unmanned aircraft, which is capable of dispersing droplets with an initial particle size of less than 50 microns in volume median diameter from a device loaded with liquid at a rate exceeding 2 liters per minute;

ハ　初期粒径が体積メディアン径で五〇ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から二リットル毎分超の割合で散布できる装置に使用するように設計したエアゾール発生装置

(c) aerosol generators that are designed to be used in a device capable of dispersing droplets with an initial particle size of less than 50 microns in volume median diameter less from a device loaded with liquid at a rate exceeding 2 liters per minute;

九　核酸の合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置であって、一部又は全部が自動化されたもののうち、一回の稼働で、連続した長さが一・五キロベースを超える核酸を五パーセント未満のエラー率で生成するように設計したもの

(ix) among devices for synthesis of nucleic acid or binding between nucleic acid and nucleic acid which are fully or partially automatized, those that are designed to generate nucleic acid with a continuous length exceeding 1.5 kilobases at an error rate of less than five percent in one operation.

第三条　輸出令別表第一の四の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 3 The goods with the specifications prescribed by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 4 of the Appended Table 1 of the Export Order are those that fall under any of the following items:

一　ロケット又はペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットの製造用の装置若しくは工具（型を含む。以下この条において同じ。）若しくは試験装置若しくはこれらの部分品

(i) rockets, or devices or tools (including molds; the same applies below in this Article) or testing devices for manufacturing rockets capable of transporting a payload over a distance of 300 kilometers or more, or their components;

一の二　ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機又はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品

(i)-2 unmanned aircraft capable of transporting a payload over a distance of 300 kilometers or more, or devices or tools or testing device for manufacturing the unmanned aircraft or their components;

一の三　エアゾールを噴霧するように設計した無人航空機であって、燃料の他に粒子又は液体状で二〇リットルを超えるペイロードを運搬するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの（前号に該当するもの又は娯楽若しくはスポーツの用に供する模型航空機を除く。）

(i)-3 for unmanned aircraft that is designed to spray aerosol transport a payload exceeding 20 liters in a particulate or liquid form in addition to fuel, one which falls under either of the following sub-items (excluding one falling under the preceding item or model aircraft used for entertainment or sports):

イ　自律的な飛行制御及び航行能力を有するもの

(a) one that has an autonomous flight control and navigation capability; or

ロ　視認できる範囲を超えて人が飛行制御できる機能を有するもの

(b) one that has a function enabling a person to control flight exceeding the visible range;

二　次のいずれかに該当する貨物又はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品

(ii) goods falling under any of the following goods, or devices or tools or testing device for manufacturing those goods, or their components:

イ　ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができる貨物であって、次のいずれかに該当するもの

(a) goods usable in rockets capable of transporting payloads over a distance of 300 kilometers or more, which fall under any of the following goods:

（一）　多段ロケットの各段

1. individual stages of multiple-stage rockets;

（二）　固体ロケット推進装置又はハイブリッドロケット推進装置であって、全力積が八四一、〇〇〇ニュートン秒以上のもの

2. solid rocket propulsion systems or hybrid rocket propulsion devices, with a total impulse of 841,000 newton-seconds or more; or

（三）　液体ロケット推進装置若しくはゲル状燃料ロケット推進装置であって、全力積が八四一、〇〇〇ニュートン秒以上のもの又はこれに組み込まれるように設計した液体ロケットエンジン若しくはゲル状燃料ロケットモータ

3. liquid rocket propulsion devices or gelatinous fuel rocket propulsion devices, with a total impulse of 841,000 newton-seconds or more or liquid rocket engines or gelatinous fuel rocket motor;

ロ　五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができる貨物であって、次のいずれかに該当するもの

(b) goods that may be used in rockets or unmanned aircraft capable of transporting a payload weighing 500 kilograms or more over a distance of 300 kilometers or more, which fall under any of the following goods:

（一）　再突入機

1. re-entry vehicles;

（二）　再突入機の熱遮へい体（セラミック又はアブレーション材料を用いたものに限る。）又はその部分品

2. thermal shields for re-entry vehicles (limited to those using ceramic or abrasion materials) or their components;

（三）　再突入機のヒートシンク又はその部分品

3. heat sinks for re-entry vehicles or their components;

（四）　再突入機に使用するように設計した電子機器

4. electronics parts that are designed to be used for re-entry vehicles;

（五）　誘導装置であって、飛行距離に対する平均誤差半径の比率が三・三三パーセント以下のもの

5. guidance system with a ratio of average error radius to flight distance of 3.33 % or less; or

（六）　推力の方向を制御する装置

6. thrust vector control device;

三　推進装置若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品

(iii) propulsion devices or their components and motor case linings or insulation materials which fall under any of the following devices, or devices or tools or testing devices for manufacturing them, or their components:

イ　ターボジェットエンジン又はターボファンエンジンであって、次のいずれかに該当するもの

(a) turbojet engines or turbo fan engines, which fall under any of the following engines:

（一）　次の１から４までの全てに該当するもの

1. those which fall under all of the following clauses i. through iv.:

１　最大推力が四〇〇ニュートンを超えるもの（最大推力が八、八九〇ニュートンを超えるものであって、本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。）

i. those whose maximum thrust exceeds 400 newtons (excluding those

whose maximum thrust exceeds 8,890 newtons, which a Japanese governmental organization has authorized them to be used in civilian aircraft);

２　燃料消費率が一時間につき推力一ニュートン当たり〇・一五キログラム以下のもの

ii. those with a fuel consumption rate of 0.15 kilograms or less per newton of thrust per hour;

３　乾燥重量が七五〇キログラム未満のもの

iii. those which are less than 750 kilograms in dry weight; and

４　一段目のローターの直径が一メートル未満のもの

iv. those whose rotor of the first stage is less than 1 meter in diameter;

（二）　五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又はペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用するように設計し、又は改造したもの（（一）に該当するものを除く。）

2. those that are designed or modified to be used for rockets capable of transporting a payload weighing 500 kilograms or more over a distance of 300 kilometers or more, or unmanned aircraft capable of transporting payloads over a distance of 300 kilometers or more (excluding those falling under clause 1.);

ロ　ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン、デトネーションエンジン若しくは複合サイクルエンジン（五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又はペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。）又はこれらの部分品

(b) ramjet engines, scramjet engines, pulse jet engines, detonation engines or combined cycle engines (limited to those usable in rockets capable of transporting a payload weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more, or unmanned aircraft capable of transporting payloads for 300 kilometers or more), or their components;

ハ　固体ロケット用のモータケースであって、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるもの

(c) motor cases for solid rockets which are usable in rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads for 300 kilometers or more;

ニ　固体ロケット用のモータケースのライニング（推進薬とモータケース又は断熱材を結合することができるものに限る。）であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用することができるもの又は五〇〇キログラム未満のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用するように設計したもの

(d) motor case linings for solid rockets (limited to those that may bind the

propellant and motor case or insulation) usable in rockets or unmanned aircraft capable of transporting a payload weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more, or those designed to be used in rockets or unmanned aircraft capable of transporting a payload weighing less than 500 kilograms for 300 kilometers or more;

ホ　固体ロケット用のモータケースの断熱材であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用することができるもの又は五〇〇キログラム未満のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用するように設計したもの

(e) motor case insulation for solid rockets, which is usable in rockets or unmanned aircraft capable of transporting a payload weighing 500 kilograms or more for 300 kilometers or more, or those designed to be used in rockets or unmanned aircraft capable of transporting a payload weighing less than 500 kilograms for 300 kilometers or more;

ヘ　固体ロケット用のモータケースのノズルであって、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるもの

(f) motor case nozzles for solid rockets which are usable in rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads for 300 kilometers or more;

ト　液体状、スラリー状又はゲル状の推進薬の制御装置であって、周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下で、かつ、加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの（五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。）又はその部分品（サーボ弁、ポンプ及びガスタービンを除く。）

(g) control devices for propellants in a liquid, slurry, or gel state, whose frequency range is 20 hertz or more and 2,000 hertz or less, and, are designed to be capable of withstanding a vibration with an effective value of acceleration exceeding 98 meters per second squared (limited to those that may be used in rockets or unmanned aircraft capable of transporting a payload weighing 500 kilograms or more over a distance of 300 kilometers or more) and their components (excluding servo valves, pumps, and gas turbines);

チ　前号イ（二）に該当するハイブリッドロケット推進装置の部分品

(h) components of hybrid rocket propulsion devices that fall under sub-item (a), clause 2. of the preceding item;

リ　液体状又はゲル状の推進薬用のタンクであって、次のいずれかに該当するものに使用するように設計したもの

(i) tanks for liquid or gelatinous propellants which are designed to be used

for those falling under any of the following clauses:

（一）　第七号に該当する推進薬又はその原料となる物質

1. propellants falling under item (vii) or their raw materials; or

（二）　液体状又はゲル状の推進薬（（一）に該当するものを除く。）であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用するもの

2. liquid or gelatinous propellants (excluding those falling under clause 1.) used in rockets capable of transporting a payload weighing 500 kilograms or more over a distance of 300 kilometers or more;

ヌ　ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用するように設計したターボプロップエンジンであって、海面上における国際民間航空機関が定める標準大気状態での最大出力が一〇キロワット以上のもの（本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。）又はその部分品

(j) turboprop engines that are designed to be used in unmanned aircraft capable of transporting payloads over a distance of 300 kilometers or more, whose maximum output is 10 kilowatts or more in a standard ambient condition on the surface of the sea specified by the International Civil Aviation Organization (excluding those certified to be used in civilian aircraft by an governmental organization of Japan) or their components;

ル　液体ロケット推進装置又はゲル状燃料ロケット推進装置の燃焼室又はノズルであって、前号イ（三）に該当する貨物に使用することができるもの

(k) combustion chambers or nozzles for liquid rocket propulsion devices or gelatinous fuel rocket propulsion devices, which are usable for goods falling under sub-item (a), 3. of the preceding item;

四　多段ロケットの切離し装置又は段間継手（五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。）又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品

(iv) separating devices or interstage joint for multiple-stage rockets (limited to those usable for rockets capable of transporting a payload weighing 500 kilograms or more over a distance of 300 kilometers or more), or devices or tools or testing devices for manufacturing them or their components;

五　しごきスピニング加工機であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に用いられる推進装置又はその部分品を製造することができるもののうち、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品

(v) among flow-forming machines capable of manufacturing propulsion devices or their components which are used for rockets or unmanned aircraft capable of transporting a payload of 500 kilograms or more over a distance of 300 kilometers or more, those falling under the following sub-items (a) and (b), or

their components:

イ　数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもの

(a) those that can be controlled by a numerical control equipment or a computer; and

ロ　輪郭制御をすることができる軸数が二を超えるもの

(b) those which have more than two shafts capable of contour control;

六　推進薬の制御装置に用いられるサーボ弁、ポンプ又はガスタービンであって、次のイ及びロに該当するもののうち、ハ、ニ又はホのいずれかに該当するもの

(vi) among servo valves, pumps, or gas turbines used for control device of propellants which fall under the following sub-items (a) and (b), those which fall under any of the clause (c), (d), or (e):

イ　液体状、スラリー状又はゲル状の推進薬の制御装置に使用するように設計したもの

(a) pumps designed to be used in control devices for propellants in liquid, slurry, or gel state; and

ロ　周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下で、かつ、加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの

(b) pumps whose frequency range is 20 hertz or more and 2,000 hertz or less, and, which are designed to be capable of withstanding a vibration with an effective rate of acceleration exceeding 98 meters per second squared;

ハ　絶対圧力が七、〇〇〇キロパスカル以上の状態において一分につき〇・〇二四立方メートル以上流すことができるように設計したサーボ弁であって、アクチュエータの応答時間が一〇〇ミリ秒未満のもの

(c) servo valves that are designed to be capable of flowing propellants for 0.024 cubic meters or more per minute in a state in which the absolute pressure is 7,000 kilopascals or more and the actuator response time is less than 100 milliseconds;

ニ　液体推進薬用のポンプであって、最大動作時の軸の回転数が一分につき八、〇〇〇回転以上のもの又は吐出し圧力が七、〇〇〇キロパスカル以上のもの

(d) pumps for liquid propellants, for which the number of shaft rotations is 8,000 or more per minute, or the discharge pressure is 7,000 kilopascals or more, at the maximum operating mode; or

ホ　液体推進薬のターボポンプ用のガスタービンであって、最大動作時の軸の回転数が一分につき八、〇〇〇回転以上のもの

(e) gas turbines of turbo pumps for liquid propellants for which the number of shaft rotations is 8,000 or more per minute at the maximum operating mode;

六の二　推進薬の制御装置に用いられるポンプに使用することができるラジアル玉軸受であって、日本産業規格Ｂ一五一四―一号で定める精度が二級以上のもののうち、次のイからハまでの全てに該当するもの

(vi)-2 among radial ball bearings usable for pumps to be used in control devices

for propellants, for which the precision specified in JIS B1514-1 is class 2 or higher, those falling under all of the following clauses (a) through (c):

イ　内輪内径が一二ミリメートル以上五〇ミリメートル以下のもの

(a) those with an internal diameter of the inner wheel of 12 millimeters or more and 50 millimeters or less;

ロ　外輪外径が二五ミリメートル以上一〇〇ミリメートル以下のもの

(b) those with an external diameterof the inner wheel of 25 millimeters or more and 100 millimeters or less;

ハ　幅が一〇ミリメートル以上二〇ミリメートル以下のもの

(c) those with a width of 10 millimeters or more and 20 millimeters or less;

七　推進薬又はその原料となる物質であって、次のいずれかに該当するもの

(vii) propellants or their raw materials, which fall under any of the following substances:

イ　濃度が七〇パーセントを超えるヒドラジン

(a) hydrazine with a concentration exceeding 70 %;

ロ　ヒドラジンの誘導体

(b) a derivative of hydrazine;

ハ　過塩素酸アンモニウム

(c) ammonium perchlorate;

ニ　アンモニウムジニトラミド

(d) ammonium dinitramide;

ホ　粒子が球形又は回転楕円体で、その径が二〇〇マイクロメートル未満のアルミニウムの粉であって、重量比による純度が九七パーセント以上のもののうち、国際規格ＩＳＯ二五九一（一九八八）又はこれと同等の規格で定める測定方法により測定した径が六三マイクロメートル未満のものの含有量が全重量の一〇パーセント以上のもの

(e) among aluminum powder whose particles are globular or spheroidal and has a diameter of less than 200 micrometers, with a weight-based purity level of 97% or more, the powder in which the content of particles whose diameter measured by the measurement method specified by the International Standard ISO 2591:1988 or an equivalent standards is less than 63 micrometers is 10% or more of the total weight;

ヘ　重量比による純度が九七パーセント以上のジルコニウム（天然の比率でジルコニウムに含まれるハフニウムを含む。）、ベリリウム、マグネシウム又はこれらの合金の粉末状のものであって、篩、レーザー回折、光学式走査等を用いて測定した粒子の径が六〇マイクロメートル未満のものの含有量が全体積又は全重量の九〇パーセント以上のもの

(f) zirconium (including hafnium contained in zirconium at a natural ratio), beryllium, or magnesium with a weight-based purity level of 97% or more, or their powdered alloys, for which the content of particles whose diameter measured using a sieve, laser diffraction, optical scanning, or other means

is less than 60 micrometers is 90% or more of the total volume or total weight;

ト　重量比による純度が八五パーセント以上のほう素又はその合金の粉末状のものであって、篩、レーザー回折、光学式走査等を用いて測定した粒子の径が六〇マイクロメートル未満のものの含有量が全体積又は全重量の九〇パーセント以上のもの

(g) boron with a weight-based purity level of 85% or more or its powdered alloys, for which the content of particles whose diameter measured using a sieve, laser diffraction, optical scanning, or other means is less than 60 micrometers is 90% or more of the total volume or total weight;

チ　燃料又は酸化剤であって、次のいずれかに該当するもの

(h) fuel or oxidizer, which fall under any of the following substances:

（一）　過塩素酸塩、塩素酸塩又はクロム酸塩であって、粉末状の金属又は燃料成分が混合されたもの

1. a perchlorate, a chlorate, or a chromate, in which a powdered metal or fuel constituent is mixed;

（二）　硝酸ヒドロキシルアンモニウム

2. hydroxylammonium nitrate;

リ　カルボラン、デカボラン、ペンタボラン又はこれらの誘導体

(i) carborane, decaborane, or pentaborane, or their derivative;

ヌ　液体酸化剤であって、次のいずれかに該当するもの

(j) a liquid oxidizer falling under any of the following clauses:

（一）　三酸化二窒素

1. dinitrogen trioxide;

（二）　二酸化窒素又は四酸化二窒素

2. nitrogen dioxide or dinitrogen tetraoxide;

（三）　五酸化二窒素

3. dinitrogen pentoxide;

（四）　窒素酸化物の混合物

4. a mixture of nitrogen oxide;

（五）　耐腐食性を有する赤煙硝酸

5. red fuming nitric acid having resistance to corrosion;

（六）　ふっ素及びその他のハロゲン、酸素又は窒素からなる化合物（気体の三ふっ化窒素を除く。）

6. a compound made from fluorine or halogens, oxygen, or nitrogen (excluding nitrogen trifluoride gas);

ル　末端にカルボキシル基を有するポリブタジエン

(k) polybutadiene having a carboxyl group at its terminal;

ヲ　末端に水酸基を有するポリブタジエン

(l) polybutadiene having a hydroxyl group at its terminal;

ワ　グリシジルアジドの重合体（末端に水酸基を有するものを含む。）

(m) a glycidyl azide polymer (including those which have a hydroxyl group at its terminal);

カ　ブタジエンとアクリル酸との重合体

(n) a polymer of butadiene and acrylic acid;

ヨ　ブタジエンとアクリロニトリルとアクリル酸との重合体

(o) a polymer of butadiene, acrylonitrile, and acrylic acid;

タ　次のいずれかに該当する推進薬

(p) a propellant falling under any of the following clauses:

（一）　一キログラム当たりの発熱量が四〇、〇〇〇、〇〇〇ジュール以上の固体及び液体の混合燃料

1. solid and liquid blended fuel with a heating value of 40,000,000 joules per kilogram

（二）　二〇度の温度かつ一気圧において計測した一立方メートル当たりの発熱量が三七、五〇〇、〇〇〇、〇〇〇ジュール以上の燃料及び燃料添加剤（化石燃料又は植物に由来する有機物を原材料として製造される燃料を用いて製造したものを除く。）

2. fuel or fuel additives with a heating value of 37,500,000,000 joules or more per cubic meter measured at a temperature of 20 degrees centigrade and 1 atmospheric pressure (excluding those produced by using fuels manufactured by using fossil fuels or organic matters derived from plants as raw materials);

レ　トリス――（二―メチル）アジリジニルホスフィンオキシド

(q) tris-1-(2-methyl) aziridinyl phosphine oxide;

ソ　テトラエチレンペンタミン、アクリロニトリル及びグリシドールの反応生成物

(r) reaction products of tetraethylenepentamine, acrylonitrile, and glycidol;

ツ　テトラエチレンペンタミン及びアクリロニトリルの反応生成物

(s) reaction products of tetraethylenepentamine and acrylonitrile;

ネ　イソフタル、トリメシン、イソシアヌル又はトリメチルアジピンの骨格を有する多官能性アジリジンアミドであって、二―メチルアジリジン基又は二―エチルアジリジン基を有するもの

(t) a multi-functional aziridineamide having an isophthal-, trimesin-, isocyanur-, or trimethyladipin- skeleton that has a 2-methylaziridine group or a 2-ethylaziridine group;

ナ　トリフェニルビスマス

(u) triphenylbismuth;

ラ　フェロセン誘導体

(v) a ferrocene derivative;

ム　トリエチレングリコールジナイトレート

(w) triethylene glycol dinitrate;

ウ　トリメチロールエタントリナイトレート

(x) trimethylolethane trinitrate;

キ　一・二・四―ブタントリオールトリナイトレート
(y) 1,2,4-butanetrioltrinitrate;
ノ　ジエチレングリコールジナイトレート
(z) diethylene glycol dinitrate;
オ　ポリテトラハイドロフランポリエチレングリコール
(aa) polytetrahydrofuran polyethlene glycol;
ク　四・五―ジアジドメチル―二―メチル―一・二・三―トリアゾール
(bb) 4,5-diazidomethyl-2-methyl--,2,3-triazole;
ヤ　メチル―ニトラトエチルニトラミン
(cc) methyl-nitrate ethyl nitramine;
マ　エチル―ニトラトエチルニトラミン
(dd) ethyl-nitrate ethyl nitramine;
ケ　ブチル―ニトラトエチルニトラミン
(ee) butyl-nitrate ethyl nitramine;
フ　ビス（二・二―ジニトロプロピル）アセタール
(ff) bis (2,2-dinitropropyl) acetal;
コ　ビス（二・二―ジニトロプロピル）フォルマール
(gg) bis (2,2-dinitropropyl) formal;
エ　アジ化ジメチルアミノエチル
(hh) dimethylaminoethyl azide;
テ　ポリグリシジルニトレート
(ii) polyglycidyl nitrate;
ア　ゲル状の推進薬であって、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように特に調合したもの
(jj) gelatinous propellant specially compounded to be used for rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads over a distance of 300 kilometers or more;
八　次のいずれかに該当する推進薬若しくはその原料となる物質の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分品（次号から第十号の二までのいずれかに該当するものを除く。）
(viii) devices or tools or testing device for producing propellants or substances to be their raw materials, or their components (excluding those falling under any of the items from the following item to item (x)-2):
イ　前号に該当する貨物
(a) goods falling under the preceding item;
ロ　オクトーゲン又はヘキソーゲン
(b) octogen or hexagen;
ハ　コンポジット推進薬
(c) a composite propellant;
ニ　二―ニトロジフェニルアミン又はN―メチル―ｐ―ニトロアニリン
(d) 2-nitrodiphenylamine or N-methyl-p-nitroaniline;

ホ　ヒドラジンニトロホルメート

(e) hydrazine nitroformate;

ヘ　ヘキサニトロヘキサアザイソウルチタン

(f) hexanitrohexaazaisowurtzitane;

九　バッチ式の混合機（液体用のものを除く。）であって、次のイからニまでの全てに該当するもの又はその部分品

(ix) batch mixers (excluding those for liquids) that fall under all of the following sub-items (a) through (d), or their components:

イ　〇以上一三・三二六キロパスカル以下の絶対圧力で混合するように設計し、又は改造したもの

(a) those that are designed or modified for mixing at an absolute pressure of more than 0 kilopascals and 13.326 kilopascals or less;

ロ　混合容器内の温度を制御することができるもの

(b) those capable of controlling the temperature inside the mixing container;

ハ　全容量が一一〇リットル以上のもの

(c) those with a total volume of 110 liters or more; and

ニ　混合機の中心軸から離れた混和軸又は捏和軸を少なくとも一本有するもの

(d) those having at least one mixing axis or a kneading axis away from the center axis of the mixer;

九の二　連続式の混合機（液体用のものを除く。）であって、次のイからハまでの全てに該当するもの又はその部分品

(ix)-2 continuous mixers (excluding those for liquids) that fall under all of the following sub-items (a) through (c), or their components:

イ　〇以上一三・三二六キロパスカル以下の絶対圧力で混合するように設計し、又は改造したもの

(a) those designed or modified for mixing at an absolute pressure of 0 kilopascals or more and 13.326 kilopascals or less;

ロ　混合容器内の温度を制御することができるもの

(b) those capable of controlling the temperature inside the mixing container;

ハ　次のいずれかに該当するもの

(c) those that fall under any of the following mixers:

（一）　二本以上の混和軸又は捏和軸を有するもの

1. those having two or more mixing axes or kneading axes; or

（二）　次の１及び２に該当するもの

2. those falling under the following clauses i. and ii.:

１　振動機能を備えた一本の回転軸を有するもの

i. those having one rotation axis with a vibration function; and

２　混合容器内及び回転軸上に捏和のための突起を有するもの

ii. those having projections for kneading inside the mixing containers and on the rotation axis;

十　第七号若しくは第八号ロからヘまでのいずれかに該当する推進薬若しくはその原

料となる物質を粉砕することができるジェットミル又はその部分品

(x) jet mills capable of pulverizing propellants falling under any of item (vii) or item (viii), sub-items (b) through (f) or substances to be their raw materials, or their components;

十の二　第七号ホからトまでのいずれかに該当する金属の粉末（噴霧粉、球形粉又は回転楕円体粉に限る。）の製造用の装置又はその部分品

(x)-2 devices for producing powder (limited to atomized powders, globular powders, or spheroidal powders) of metals falling under any of item (vii), sub-iems (e) through (g), or their components;

十一　複合材料、繊維、プリプレグ又はプリフォーム（ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。）の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品

(xi) devices for producing composites, fibers, prepregs, or preforms (limited to those usable in rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads over a distance of 300 kilometers or more), which fall under any of the following sub-items, or their components or accessories:

イ　フィラメントワインディング装置、ファイバープレイスメント装置又はトウプレイスメント装置であって、繊維を位置決めし、包み作業及び巻き作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が三以上のもの又はその制御装置

(a) among filament winding machines, fiber placement machines, or tow placement machines, which conduct positioning of fibers, wrapping operations, and winding operations, those with three or more axes capable of controlling those operations in correlation, or their control devices;

ロ　テープレイング装置であって、複合材料からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するために、テープを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が二以上のもの

(b) among tape-laying machines that conduct operations of positioning and laminating of tape to manufacture bodies of aircraft or structures of rockets that are composed of composite materials, those with two or more shafts capable of controlling those operations in correlation;

ハ　三次元的に織ることができる織機又はインターレーシングマシン

(c) weaving machines or interlacing machines capable of three-dimensional weaving;

ニ　繊維の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの

(d) devices for producing fibers, which fall under any of the following devices:

（一）　重合体繊維から他の繊維を製造する装置

1. devices for producing other fibers from polymer fibers;

（二）　熱したフィラメント状の基材に元素又は化合物を蒸着させるための装置

2. devices for performing vapor deposition of elements or compounds on

base materials in a heated filament form;

（三）　耐火セラミックの湿式紡糸装置

3. wet type spinning apparatus for fire-resistant ceramics;

ホ　繊維の表面処理又はプリプレグ若しくはプリフォームの製造を行うように設計したもの

(e) devices that are designed for surface finishing of fibers or for producing prepregs or preforms;

十二　ノズルであって、原料ガスの熱分解（一、三〇〇度以上二、九〇〇度以下の温度範囲において、かつ、一三〇パスカル以上二〇、〇〇〇パスカル以下の絶対圧力の範囲において行うものに限る。）により生成する物質を基材に定着させるためのもの

(xii) nozzles used for fixing substances generated from the thermal decomposition of source gas onto base materials (limited to thermal decomposition conducted in the temperature range between 1,300 degrees centigrade or more and 2,900 degrees centigrade or less, and, absolute pressure range between 130 pascals or more and 20,000 pascals or less);

十三　ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその制御装置

(xiii) devices for producing nozzles of rocket propulsion devices or nose of re-entry vehicles, which fall under either of the following devices or their control devices:

イ　構造材料の炭素の密度を増加させるためのもの

(a) those for increasing the density of carbon of structural materials; or

ロ　原料ガスの熱分解により生成する炭素を基材に定着させるためのもの

(b) those for fixing carbon generated from thermal decomposition of source gas onto base materials;

十四　アイソスタチックプレスであって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその制御装置

(xiv) isostatic presses falling under all of the following sub-items (a) through (c) or their control devices:

イ　最大圧力が六九メガパスカル以上のもの

(a) those with maximum pressure of 69 megapascals or more;

ロ　中空室内の温度制御ができるもの（中空室内の温度が六〇〇度以上の場合に限る。）

(b) those capable of temperature control inside hollow chambers (limited to the case in which the temperature inside a hollow chamber is 600 degrees centigrade or more); and

ハ　中空室の内径が二五四ミリメートル以上のもの

(c) those with an internal diameter of a hollow chamber of 254 millimeters or more;

十五　炭素及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した

炉であって、化学的気相成長用のもの又はその制御装置

(xv) furnaces that are designed to increase the desnsity of carbon of composite materials using carbon or carbon fibers, for chemical vapor deposition or their control devices;

十六　構造材料であって、次のいずれかに該当するもの

(xvi) structural materials falling under any of the following sub-items:

イ　比強度が七六、二〇〇メートルを超え、かつ、比弾性率が三、一八〇、〇〇〇メートルを超える繊維で補強した有機物若しくは金属をマトリックスとするものからなる複合材料（プリプレグであって、ガラス転移点が一四五度以下のものを除く。）又はその成型品（ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット、無人航空機又は第二号イ若しくはロに該当する貨物に使用するように設計したものに限る。）

(a) composites made from organic matters reinforced by fibers with a specific strength exceeding 76,200 meters, and, specific modulus exceeding 3,180,000 meters or metal matrix composites (excluding prepregs with a glass transition point of 145 degrees centigare or less), or their molded products (limited to those that are designed to be used in rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads over a distance of 300 kilometers or more or goods falling under item (ii), sub-item (a) or (b));

ロ　ロケット用に設計した炭素及び炭素繊維を用いた複合材料又はその成型品（ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。）

(b) composite materials using carbon and carbon fibers which are designed to be used for rockets, or their molded products (limited to those usable in rockets or unmanned aircraft capable of transporting a payload weighing 500 kilograms or more over a distance of 300 kilometers or more);

ハ　人造黒鉛であって、次のいずれかに該当するもの（ロケットのノズル又は再突入機の先端部に使用することができるものに限る。）

(c) artificial graphite falling under any of the following clauses (limited to those usable for nozzle of rockets or nose of re-entry vehicles):

（一）　一五度の温度で測定したときのかさ密度が一立方センチメートル当たり一・七二グラム以上、かつ、粒子の径が一〇〇マイクロメートル以下の人造黒鉛であって、次のいずれかに加工することができるもの

1. artificial graphite whose bulk density measured at 15 degrees centigrade is 1.72 grams or more per cubic centimeter, and, whose particle diameter is 100 micrometers or less, which may be processed into any of the following things:

1　円筒であって、直径が一二〇ミリメートル以上、かつ、高さが五〇ミリメートル以上のもの又は管であって、内径が六五ミリメートル以上、厚さが二五ミリメートル以上、かつ、高さが五〇ミリメートル以上のもの

i. cylinders with a diameter of 120 millimeters or more, and, a height of 50

millimeters or more, or tubes with an inner diameter of 65 millimeters or more, a thickness of 25 millimeters or more, and, a height of 50 millimeters or more;

２　直方体であって、各辺の長さがそれぞれ一二〇ミリメートル以上、一二〇ミリメートル以上及び五〇ミリメートル以上のもの

ii. a rectangular parallelepiped, with each side length of 120 millimeters or more, 120 millimeters or more, and 50 millimeters or more, respectively;

（二）　熱分解黒鉛（ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。）

2. pyrolytic graphite (limited to one usable in rockets capable of transporting payloads over a distance of 300 kilometers or more, or unmanned aircraft capable of transporting a payload weighing 500 kilograms or more over a distance of 300 kilometers or more);

（三）　繊維で強化した黒鉛（ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。）

3. graphite strengthened with fibers (limited to one usable in rockets capable of transporting payloads over a distance of 300 kilometers or more or unmanned aircraft capable of transporting a payload weighing 500 kilograms or more over a distance of 300 kilometers or more);

ニ　ロケット又は無人航空機のレードーム（ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。）に使用するためのセラミックの複合材料（一〇〇メガヘルツ以上一〇〇ギガヘルツ以下の範囲のいずれかの周波数における比誘電率が六未満のものに限る。）

(d) ceramic composite materials to be used in radomes (limited to those usable in rockets capable of transporting payloads over a distance of 300 kilometers or more or unmanned aircraft capable of transporting a payload weighing 500 kilograms or more over a distance of 300 kilometers or more) for rockets or unmanned aircraft (limited to radomes with the relative permittivity of less than 6 in any of the frequencies within the range of between 100 megahertz or more and 100 gigahertz or less);

ホ　ロケット若しくは無人航空機の先端部、再突入機又はノズルフラップ（ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。）に使用することができる炭化けい素で強化された未焼成セラミック又は強化された炭化けい素セラミック複合材料

(e) unfired ceramics reinforced by silicon carbide or reinforced silicon carbide ceramic composite materials usable for the nose of rockets or unmanned

aircraft, re-entry vehicles, or nozzle flaps (limited to those usable in rockets capable of transporting payloads over a distance of 300 kilometers or more or unmanned aircraft capable of transporting a payload weighing 500 kilograms or more over a distance of 300 kilometers or more);

ヘ　ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機の部分品（先端部、再突入機、翼の前縁部、推力偏向板、操縦翼面又はロケットモータのノズルスロート部を含む。）に使用することができるセラミック複合材料であって、融点が三、〇〇〇度以上の超高温セラミック（二ほう化チタン、二ほう化ジルコニウム、二ほう化ニオブ、二ほう化ハフニウム、二ほう化タンタル、炭化チタン、炭化ジルコニウム、炭化ニオブ、炭化ハフニウム及び炭化タンタルを含む。）のマトリックスを繊維又はフィラメントで強化したものからなるもの

(f) ceramic composite materials usable for components of rockets or unmanned aircraft capable of transporting a payload over a distance of 300 kilometers or more (including the nose, reentry vehicles, leading edge of wings, thrust deflection plate, control surface, or the nozzle throat of rocket motors) which are composed of matrix reinforced by fibers or filaments of ultra-high temperature ceramics with a melting point of 3,000 degrees or more (including titanium diboride, zirconium diboride, niobium diboride, hafnium diboride, tantalum diboride, titanium carbide, zirconium carbide, niobium carbide, hafnium carbide, and tantalum carbide);

ト　次のいずれかに該当するタングステン、モリブデン若しくはこれらの合金を主たる構成物質とする粉又はその粉を固めたもの（ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機の構造材料として用いることができるものに限る。）

(g) powder whose main constitutive substance is tungsten, molybdenum or their alloys which fall under any of the following powder, or their solidified powder (limited to those usable as structural materials for rockets or unmanned aircraft capable of transporting a payload over a distance of 300 kilometers or more):

（一）　タングステン又はタングステンの含有量が合金の全重量の九七パーセント以上の粉であって、その粒子の径が五〇マイクロメートル以下のもの

1. tungsten or powder with a tungsten content of 97% or more of the total weight of alloys, with a particle whose diameter is 50 micrometers or less;

（二）　モリブデン又はモリブデンの含有量が合金の全重量の九七パーセント以上の粉であって、その粒子の径が五〇マイクロメートル以下のもの

2. molybdenum or powder with a molybdenum content of 97% or more of the total weight of alloys, with a particle whose diameter is 50 micrometers or less;

（三）　タングステン又はタングステンの含有量がその合金の全重量の九七パーセント以上（銅又は銀を含浸させたものである場合にあっては、タングステンの

含有量が合金の全重量の八〇パーセント以上。）の粉を固めたものであって、次のいずれかに該当するものに加工することができるもの

3. solidified powder of tungsten or powder with a tungsten content of 97% or more of the total weight of its alloys (for those impregnated with copper or silver, with a tungsten content of 80% or more of the total weight of the alloys), which can be processed into any of the following things:

１　円筒であって、直径が一二〇ミリメートル以上、かつ、高さが五〇ミリメートル以上のもの又は管であって、内径が六五ミリメートル以上、厚さが二五ミリメートル以上、かつ、高さが五〇ミリメートル以上のもの

i. cylinders with a diameter of 120 millimeters or more, and, a height of 50 millimeters or more, or tubes with an inner diameter of 65 millimeters or more, a thickness of 25 millimeters or more, and a height of 50 millimeters or more;

２　直方体であって、各辺の長さがそれぞれ一二〇ミリメートル以上、一二〇ミリメートル以上及び五〇ミリメートル以上のもの

ii. a rectangular parallelepiped with the length of each side of 120 millimeters or more, 120 millimeters or more, and 50 millimeters or more, respectively;

チ　ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるマルエージング鋼であって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(h) maraging steels usable in rockets capable of transporting payloads over a distance of 300 kilometers or more or unmanned aircraft capable of transporting a payload weighing 500 kilograms or more over a distance of 300 kilometers or more, which fall under the following clauses 1. and 2.:

（一）　次のいずれかに該当するもの

1. those falling under either of the following clauses:

１　固溶化熱処理段階で二〇度の温度において測定した最大引張強さが九〇〇、〇〇〇、〇〇〇パスカル以上のもの

i. those that have a maximum tensile strength of 900,000,000 pascals or more measured at the solution heat treatment stage at 20 degrees centigrade; or

２　析出硬化熱処理段階で二〇度の温度において測定した最大引張強さが一、五〇〇、〇〇〇、〇〇〇パスカル以上のもの

ii. those that have a maximum tensile strength of 1,500,000,000 pascals or more measured at the precipitation hardening treatment stage at 20 degrees centigrade;

（二）　次のいずれかに該当するもの

2. those falling under either of the following things:

１　厚さが五ミリメートル以下の板又は管

i. plates or tubes with a thickness of 5 mm or less; or

２　厚さが五〇ミリメートル以下の管であって、かつ、内径が二七〇ミリメートル以上のもの

ii. tubes with a thickness of 50 mm or less, and, an internal diameter of 270 millimeters or more;

リ　チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼であって、次の（一）及び（二）に該当するもの（ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。）

(i) austenitic-ferritic stainless steel stabilized by titanium, which falls under the following clauses 1. and 2. (limited to those usable in rockets capable of transporting payloads over a distance of 300 kilometers or more or unmanned aircraft capable of transporting a payload weighing 500 kilograms or more over a distance of 300 kilometers or more):

（一）　次の１から３までのすべてに該当するもの

1. those falling under all of the following clauses i. through iii.:

１　クロムの含有量が全重量の一七パーセント以上二三パーセント以下で、かつ、ニッケルの含有量が全重量の四・五パーセント以上七パーセント以下のもの

i.those with a chrome content of 17% or more and 23% or less of the total weight, and, a nickel content of 4.5 % or more and 7 % or less of the total weight;

２　チタンの含有量が全重量の〇・一パーセントを超えるもの

ii. those with a titanium content exceeding 0.1 % of the total weight; and

３　オーステナイト組織を示す部分が全体積の一〇パーセント以上のもの

iii. those with the part that has an austenitic structure which is 10% or more of the total volume;

（二）　次のいずれかに該当するもの

2. those falling under any of the following clauses:

１　塊又は棒であって、寸法の最小値が一〇〇ミリメートル以上のもの

i. an ingots or a rod with the minimum dimension of 100 millimeters or more;

２　シートであって、幅が六〇〇ミリメートル以上で、かつ、厚さが三ミリメートル以下のもの

ii. a sheet with a width of 600 millimeters or more, and, a thickness of 3 millimeters or less; or

３　管であって、外径が六〇〇ミリメートル以上で、かつ、厚さが三ミリメートル以下のもの

iii. a tube with an external diameter of 600 millimeters or more, and, a thickness of 3 millimeters or less;

十七　加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置、航法装置若

しくは磁気方位センサーであって、次のいずれかに該当するもの（ロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。）又はこれらの部分品

(xvii) accelerometers or gyroscopes or device, navigation equipment, or magnetic director sensors using them, which fall under any of the following equipment (limited to those usable in rockets or unmanned aircraft), or their components:

イ　ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した航法装置であって、ジャイロスタビライザー又は自動操縦装置とともに使用するように設計したもの

(a) navigation equipment that are designed to be used in rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads over a distance of 300 kilometers or more, which are designed to be used together with a gyrostabilizer or an automatic pilot;

ロ　ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置

(b) gyro-astro compasses, or devices that are capable of determining positions or courses by automatically tracking celestial bodies or artificial satellites;

ハ　直線加速度計であって、慣性航法装置用又は誘導装置用に使用するように設計したもののうち、スケールファクターの再現性が一年間につき〇・一二五パーセント未満であって、バイアスの再現性が一年間につき〇・〇一二二六三メートル毎秒毎秒未満のもの（ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。）

(c) among linear accelerometers that are designed to be used in inertial navigation systems or guidance equipment with scale factor repeatability of less than 0.125% per year and bias repeatability of less than 0.012263 meters per second squared per year (limited to those usable in rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads over a distance of 300 kilometers or more);

ニ　ジャイロスコープであって、九・八一メートル毎秒毎秒の直線加速度の状態におけるドリフトレートの安定性が一時間につき〇・五度未満のもの（ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。）

(d) gyroscopes with a drift rate stability of less than 0.5 degrees per hour in a linear acceleration state of 9.81 meters per second squared (limited to those usable in rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads over a distance of 300 kilometers or more);

ホ　加速度計又はジャイロスコープであって、慣性航法装置又は誘導装置に使用するように設計したもののうち、九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの

(e) among accelerators or gyroscopes that are designed to be used in inertial navigation systems or guidance equipment, those that are designed to be

capable of being used at a linear acceleration exceeding 981 meters per second squared;

ヘ　ハ若しくはホに該当する加速度計又はニ若しくはホに該当するジャイロスコープを用いた装置（姿勢方位基準装置、ジャイロコンパス、慣性計測装置、慣性航法装置及び慣性基準装置を含む。）

(f) devices using an accelerometer falling under sub-item (c) or (e) or a gyroscope falling under sub-item (d) or (e) (including attitude and heading reference systems, gyro compasses, inertial measurement units, inertial navigation systems, and inertial reference systems);

ト　磁気方位センサーであって、次の（一）から（三）までのすべてに該当するもののうち、軸数が三のもの

(g) magnetic director sensors that fall under all of the following clauses 1. through 3., that has three axes:

（一）　ピッチ角（プラスマイナス九〇度）及びロール角（プラスマイナス一八〇度）の内部傾き補正を有するもの

1. those with an internal tilt correction of pitch (plus or minus 90 degrees) and roll (plus or minus 180 degrees);

（二）　緯度プラスマイナス八〇度の地点における方位角精度の実効値が局所磁場に対して〇・五度未満のもの

2. those the root mean squared value of azimuth accuracy at the point of plus/minus 80 degrees latitude is less than 0.5, relative to local magnetic field;

（三）　飛行制御又は航法システムと統合するように設計したもの

3. those that are designed to be integrated with flight control or navigation systems;

十七の二　ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した統合された航法システムであって、平均誤差半径が二〇〇メートル以下の精度のもの

(xvii)-2 integrated navigation systems that are designed to be used in rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads over a distance of 300 kilometers or more, and with an accuracy of a circular error probability of 200 meters or less;

十七の三　加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置、航法装置、磁気方位センサー又は統合された航法システムの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(xvii)-3 accelerometers or gyroscopes or devices, navigation equipment, magnetic director sensors using them, or devices or tools, testing device, calibration equipment or alignment equipment for producing integrated navigation systems, or their components, which fall under any of the following sub-items:

イ　前二号に該当するものの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置（ロからへまでのいずれかに該当するものを除く。）又はこれらの部分品

(a) devices or tools, testing device, calibration equipment, or alignment equipment for producing the devices falling under the preceding two items (excluding those falling under any of the following sub-items (b) through (f)), or their components;

ロ　遠心力式釣合い試験機（歯科用装置又は医療用装置を試験するように設計したものを除く。）であって、次の（一）から（四）までのすべてに該当するもの

(b) centrifugal balancing machines (excluding those designed for testing dental equipment or medical equipment) falling under all of the following clauses 1. through 4.:

（一）　重量が三キログラムを超えるロータを試験することができないもの

1. those that are not capable of testing rotors exceeding 3 kilograms;

（二）　一分につき一二、五〇〇回転を超える回転数でロータを試験することができるもの

2. those capable of testing rotors with a rotation speed exceeding 12,500 rotations per minute;

（三）　二面以上での不釣合いを試験できるもの

3. those capable of testing imbalance on two or more planes;

（四）　ロータの重量に対する残留不釣合いが一キログラムにつき〇・二グラムミリメートル以下のもの

4. those with residual unbalance for the weight of rotor of 0.2 gram-millimeters or less per kilogram;

ハ　表示装置であって、ロに該当するものに使用することができるように設計したもの

(c) display device that are designed to be capable of being used in the machines falling under sub-item (b);

ニ　モーションシミュレーター又はレートテーブルであって、次の（一）から（三）までのすべてに該当するもの（工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。）

(d) motion simulators or rate tables falling under all of the following clauses 1. through 3. (excluding those that are designed to be usable for machine tools or medical devices):

（一）　軸数が二以上のもの

1. those with two or more axes;

（二）　スリップリング又は電力の供給若しくは信号情報の伝達を行うことができる非接触型の装置を用いるもの

2. those that use a slip ring, or non-contact type devices capable of supplying electric power or transmitting signal information;

（三）　次のいずれかに該当するもの

3. those falling under any of the following clauses:

１　いずれかの軸における角速度が一秒につき四〇〇度以上又は三〇度以下のものであって、当該角速度の分解能が一秒につき六度以下のもののうち、当該角速度の精度が一秒につき〇・六度以下のもの

i. among those for which the angular velocity in any of the axis is 400 degrees or more or 30 degrees or less per second, and the resolving power of the angular velocity of 6 degrees or less per second, those with the accuracy of the angular velocity of 0.6 degrees or less per second;

２　いずれかの軸が一〇度以上回転する場合における角速度が、〇・〇五パーセント以下の精度で安定するもの

ii. those for which the angular velocity when the rotation of any of the axes rotates 10 degrees or more is stabilized at the accuracy of 0.05% or less;

３　角度の位置決め精度が五秒以下のもの

iii. those with an accuracy of angular positioning of 5 seconds or less;

ホ　ポジショニングテーブルであって、次の（一）及び（二）に該当するもの（工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。）

(e) positioning tables falling under the following clauses 1. and 2. (excluding those designed for use in machine tools or medical devices):

（一）　軸数が二以上のもの

1. those with two or more axes; and

（二）　角度の位置決め精度が五秒以下のもの

2. those with an accuracy of angular positioning of 5 seconds or less;

ヘ　遠心加速度試験機であって、九八〇メートル毎秒毎秒を超える加速度を与えることができ、スリップリング又は電力の供給若しくは信号情報の伝達を行うことができる非接触型の装置を用いるもの

(f) centrifugal accelerator testing machines that are capable of applying an acceleration rate exceeding 980 meters per second squared, which use a slip ring or non-contact type device capable of supplying electricity or transmitting signal information;

十八　五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した飛行制御装置又は姿勢制御装置

(xviii) flight control device or attitude control device that are designed to be used in rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more over a distance of 300 kilometers or more;

十八の二　前号に掲げるものに使用するように設計したサーボ弁であって、周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下の全域において加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの

(xviii)-2 servo valves that are designed to be used in devices stated in the preceding item, and to be able to withstand vibrations with an effective value of acceleration exceeding 98 meters per second squared in all the frequency

ranges from 20 hertz to 2,000 hertz;

十八の三　前二号に掲げるものの試験装置、校正装置又は心合わせ装置

(xviii)-3 testing device, calibration equipment, or alignment equipment for the devices stated in the preceding two items;

十九　アビオニクス装置であって、次のいずれかに該当するもの

(xix) avionics equipment falling under any of the following clauses:

イ　レーダー（五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計したものに限る。）

(a) radars (limited to those usable for rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more over a distance of 300 kilometers or more);

ロ　パッシブセンサーであって、特定の電磁波源の方向又は地形の特性を探知するもの（五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計したものに限る。）

(b) passive sensors for detecting the direction of a specific electromagnetic wave source or landform characteristics (limited to those designed to be used in rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more over a distance of 300 kilometers or more);

ハ　衛星航法システム（全地球航法衛星システム及び地域航法衛星システムを含む。）からの電波を受信する装置であって、次の（一）若しくは（二）に該当するもの又はそのために特に設計した部分品

(c) devices for receiving radio waves from a satellite navigation system (including a global navigation satellite system and an area navigation satellite system), which falls under the following clause 1. or 2., or components specially designed for that purpose:

（一）　五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計したもの

1. those designed to be used in rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more over a distance of 300 kilometers or more;

（二）　航行又は飛しょうする移動体に使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

2. those designed to be used in mobile bodies that navigate or fly, which fall under any of the following clauses:

１　毎秒六〇〇メートルを超える速度のもとで、航法に係る情報を提供することができるもの

i. those capable of providing information related to navigation in the speed exceeding 600 meters per second;

２　軍隊又は政府機関による使用を目的として設計若しくは改良され、かつ、衛星航法システム（全地球航法衛星システム及び地域航法衛星システムを含む。）

で用いられる暗号化された信号又はデータにアクセスするための暗号の復号機能を有するもの（民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。）

ii. those designed or improved for the purpose of being used by the military forces or governmental organizations, and, has a function for decoding codes for accessing encoded signals or data used in a satellite navigation system (including a global navigation satellite system and an area navigation satellite system) (excluding those designed to receive navigational data for private use or for ensuring the safety of human life and physical safety);

３　意図的な妨害を受ける環境のもとで機能することを目的として、ナルステアラブルアンテナ、電子的に走査が可能なアンテナその他妨害除去機能を有するように設計したもの（民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。）

iii. those designed to have a null-steerable antenna, an antenna capable of electronic scanning, or other functions of impedance elimination for the purpose of functioning in an environment where intentional impedance is received (excluding those designed to receive navigational data for private use or for ensuring the safety of human life and physical safety);

ニ　ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用するように設計したアンビリカル電気コネクタ又は段間電気コネクタ（ペイロードとロケットの間の電気コネクタを含む。）

(d) umbilical electrical connectors or staging electrical connectors (including electrical connectors between payloads and rockets) designed for use in rockets capable of transporting payloads over a distance of 300 kilometers or more;

十九の二　ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるように設計した熱電池であって、電解質として固体の非導電無機塩類を含むもの

(xix)-2 thermal batteries designed for use in rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads over a distance of 300 kilometers or more, and which contain solid non-conducting inorganic salt as the electrolyte;

二十　航空機搭載用又は船舶搭載用の重力計であって、精度が〇・七ミリガル以下のもののうち、測定所要時間が二分以内のもの（五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。）又はこれらの部分品

(xx) among gravity meters for aircraft or ship mounting with precision of 0.7 milligals or less, those the time required for measurement of which is within 2 minutes (limited to those usable in rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more over a distance of 300 kilometers or more) or their components;

二十の二　航空機搭載用若しくは船舶搭載用の重力勾配計（五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。）又はこれらの部分品

(xx)-2 gravity gradiometers for aircraft or ship (limited to those usable in rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more over a distance of 300 kilometers or more) or their components;

二十一　ロケット又は無人航空機の発射台又は地上支援装置であって、次のいずれかに該当するもの

(xxi) launch pads or ground support equipment for rockets or unmanned aircraft, which fall under either of the following sub-items:

イ　ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機の取扱い、制御、作動又は発射用に設計した装置

(a) equipment designed for handling, controlling, operating, or launching rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads over a distance of 300 kilometers or more; or

ロ　五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機の輸送、取扱い、制御、作動又は発射用に設計した車両

(b) vehicles designed for transporting, handling, controlling, operating, or launching rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more over a distance of 300 kilometers or more;

二十二　ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した無線遠隔測定装置又は無線遠隔制御装置（地上装置を含む。）であって、次のいずれにも該当しないもの

(xxii) radio telemetry equipment or radio telecontroller (including ground equipment) that is designed for use in rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads over a distance of 300 kilometers or more and that does not fall under any of the following sub-items:

イ　有人航空機又は人工衛星に使用するように設計したもの

(a) those designed for use in manned aircraft or artificial satellites;

ロ　陸上又は海洋において用いられる移動体に使用するように設計したもの

(b) those designed for use in mobile bodies used on land or the sea;

ハ　民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを提供する衛星航法システムからの情報を受信するように設計したもの

(c) those designed to receive information from satellite navigational systems for providing navigational data for private use or for ensuring the safety of human life and physical safety;

二十二の二　ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができる追跡装置であって、次のいずれかに該当するもの

(xxii)-2 tracking devices usable in rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads over a distance of 300 kilometers or more, which fall under either of the following sub-items:

イ　ロケット又は無人航空機に搭載されたコード変換器を使用するものであって、地上、海上若しくは飛しょう体上の連携機器又は衛星航法システムとの相互連携の下で、即時に飛行位置及び速度のデータを計測することができるもの

(a) tracking devices using code converters mounted in rockets or unmanned aircraft and capable of instantly measuring flight position and speed data in a mutual coordination with linked devices on ground, the sea or flying objects, or with a satellite navigational system;

ロ　距離測定用のレーダーであって、光を利用した追跡装置を有するもののうち、次の（一）から（三）までのすべてに該当するもの

(b) among radars for distance measurement having a tracking device that use light, those falling under all of the following clauses 1. through 3.:

（一）　角度分解能が一・五ミリラジアン未満のもの

1. radars with angular resolving power less than 1.5 milliradians;

（二）　距離分解能の二乗平均が一〇メートル未満で測定することができる距離が三〇キロメートル以上のもの

2. radars with the square mean value of distance resolving power less than 10 meters and capable of measuring distances 30 kilometers or more;

（三）　速度分解能が一秒につき三メートル未満のもの

3. radars with speed resolving power less than 3 meters per second;

二十三　五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに搭載するように設計したアナログ電子計算機又はデジタル電子計算機であって、次のいずれかに該当するもの

(xxiii) analog computers or digital computers designed for use in a rocket capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more over a distance of 300 kilometers or more, which fall under either of the following sub-items:

イ　零下四五度より低い温度から五五度を超える温度まで使用することができるように設計したもの

(a) computers designed to be usable from below -45 degrees centigrade to over 55 degrees centigrade; or

ロ　全吸収線量がシリコン換算で五〇万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計したもの

(b) computers designed to be able to withstand radiation irradiation total absorbed dose which is 500,000 rads or more on a silicon conversion basis;

二十四　アナログデジタル変換用の集積回路又はアナログデジタル変換器（五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。）であって、次のいずれかに該当するもの

(xxiv) integrated circuits for analog-to-digital conversion or analog-to-digital converters (limited to those usable in rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more over a distance of 300 kilometers or more), which that fall under either of the following sub-items:

イ　アナログデジタル変換用の集積回路であって、全吸収線量がシリコン換算で五〇万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計したもの又は次の（一）及び（二）に該当するもの

(a) integrated circuits for analog-to-digital conversion which are designed to be able to withstand radiation exposure, for which the total absorbed dose is 500,000 rads or more on a silicon conversion basis, or which fall under the following clauses 1. and 2.:

（一）　零下五四度より低い温度から一二五度を超える温度まで使用することができるように設計したもの

1. integrated circuits designed to be usable at a temperature lower than 54 degrees centigrade below zero to higher than 125 degrees centigrade;

（二）　気密封止したもの

2. integrated circuits that are sealed airtight;

ロ　電気入力型のアナログデジタル変換用の組立品又はモジュールであって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(b) assemblies or modules for electronic input-type analog-to-digital conversion which fall under the following clauses 1. and 2.:

（一）　零下四五度より低い温度から八〇度を超える温度まで使用することができるように設計したもの

1. assemblies or modules designed to be usable at temperatures lower than 45 degrees centigrade below zero to higher than 80 degrees centigrade; and

（二）　イに該当する集積回路を組み込んだもの

2. assemblies or modules that incorporate an integrated circuit falling under sub-item (a);

二十五　振動試験装置若しくはその部分品、空気力学試験装置、燃焼試験装置、環境試験装置又は電子加速器若しくはこれを用いた装置であって、次のいずれかに該当するもの

(xxv) vibration testing device or its components, aerodynamic testing device, combustion testing device, environmental testing device, electron accelerators, or devices using them, which fall under any of the following sub-items:

イ　振動試験装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの（ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。）

(a) vibration testing device or their components falling under any of the

following clauses (limited to those usable in the development or testing of rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads over a distance of 300 kilometers or more, or goods falling under item (ii)):
（一）　デジタル制御方式の振動試験装置であって、次の１及び２に該当するもの
1. digitally controlled vibration testing devices that fall under the following clauses i. and ii.:
１　試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上のものであって、二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下のいずれの周波数においても加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒以上の振動を発生させることができるもの
i. those with an exciting force of 50 kilonewtons or more in a state in which there is no test specimen and capable of generating vibrations with an effective value of acceleration of 98 meters or more per second squared even at a frequency of 20 hertz or more and 2,000 hertz or less; and
２　フィードバック制御技術又は閉ループ制御技術を用いたもの
ii. those using feedback control technology or closed-loop control technology;
（二）　振動試験装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの（ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。）
2. components of vibration testing device falling under any of the following clauses (limited to those usable for the development or testing of rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads for 300 kilometers or more, or goods falling under item (ii)):
１　（一）に該当する振動試験装置の制御に使用するように設計した部分品であって、振動試験用のプログラムを用いたものであり、かつ、五キロヘルツを超える帯域幅で実時間での振動試験をデジタル制御するもの
i. components that are designed to be used for controlling the vibration testing device falling under clause 1. which use a program for vibration testing, and, digitally control vibration testing in real time in a bandwidth exceeding 5 kilohertz;
２　（一）に該当する振動試験装置に使用することができる振動発生機であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上のもの
ii. vibration generators usable for vibration testing device falling under clause 1., with an exciting force of 50 kilonewtons or more in a state in which there is no test specimen;
３　（一）に該当する振動試験装置に使用することができる振動台又は振動発生装置の部分品であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上となる振動を発生させるために二台以上の振動発生機を接続して使用するように設計したもの

iii. components of vibration tables or vibration generators usable for vibration testing device falling under clause 1., which are designed to be used by connecting two or more vibration generators in order to generate vibrations with an exciting force of 50 kilonewtons or more in a state in which there is no test specimen;

ロ　マッハ数が〇・九以上の速度の状態を作ることができる空気力学試験装置（ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第一号の三に該当する無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。マッハ数が三以下で、かつ、測定部断面の長さが二五〇ミリメートル以下の風洞及びへに該当するものを除く。）

(b) aerodynamic testing devices capable of creating a state in which the speed is Mach 0.9 or more (limited to those usable for the development or testing of rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads over a distance of 300 kilometers or more, unmanned aircraft falling under item (i)-3, or goods falling under item (ii); excluding wind tunnels with a speed of Mach 3 or less, and, for which the length of the cross section of the measurement part is 250 millimeters or less and those falling under sub-item (f));

ハ　燃焼試験装置であって、推力が六八キロニュートンを超える固体ロケット、液体ロケット若しくはロケット推進装置を試験することができるもの又は同時に三軸方向の推力成分を測定することができるもの（ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。）

(c) combustion testing device capable of testing solid rockets and liquid rockets with thrust exceeding 68 kilonewtons or rocket propulsion devices, or capable of simultaneously measuring the thrust component in the triaxial direction (limited to those usable for the development or testing of rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads over a distance of 300 kilometers or more, or goods falling under item (ii));

ニ　飛行の状態をシミュレートすることができる環境試験装置であって、次の（一）及び（二）に該当するもの（ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第一号の三に該当する無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。）

(d) environmental testing devices that are capable of simulating the flying state and fall under the following clauses 1. and 2. (limited to those usable for developing or testing rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads over a distance of 300 kilometers or more, unmanned aircraft falling under item (i)-3, or goods falling under item (ii)):

（一）　高度が一五、〇〇〇メートル以上の状態又は零下五〇度以上一二五度以下のすべての温度範囲の状態をシミュレートすることができるもの

1. those capable of simulating the state in which the altitude is 15,000

meters or more, or the state in which all the temperature range between minus 50 degrees centigrade or more and 125 degrees centigrade or less;

（二）　周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下で、かつ、試験体がない状態における加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒以上の振動を発生させることができるもの（加振力が五キロニュートン以上のものに限る。）又は基準音圧が二〇マイクロパスカルの場合の音圧レベルが一四〇デシベル以上の音を発生させることができるもの若しくは定格の音響出力の合計が四キロワット以上のもの

2. those capable of generating a vibration in the frequency range between 20 hertz or more and 2,000 hertz or less, and, an effective value of acceleration of 98 meters or more per second squared in a state in which there is no test specimen (limited to those with an exciting force of 5 kilonewtons or more), or those capable of generating sounds with the sound pressure level of 140 decibels or more when the reference sound pressure is 20 micropascals or with the total rated sound output of 4 kilowatts or more;

ホ　電子加速器であって、二メガエレクトロンボルト以上のエネルギーを有する加速された電子からの制動放射によって電磁波を放射することができるもの又はこれを用いた装置（医療用に設計したものを除き、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。）

(e) electron accelerators capable of emitting electromagnetic waves by a bremsstrahlung from accelerated electrons that have an energy of 2 megaelectron volts or more or devices using electron accelerators (excluding those designed for medical use and limited to those usable for developing or testing rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads over a distance of 300 kilometers or more, or goods falling under item (ii));

ヘ　熱空気力学試験装置（物体の周辺の気流による熱的及び機械的影響を調査するためのプラズマアークジェット装置及びプラズマ風洞を含む。）であって、次のいずれかに該当するもの（ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機若しくは第二号イ若しくはロに該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。）

(f) aerothermodynamic testing devices (including plasma arcjet equipment and plasma wind tunnels for investigating thermal and mechanical effects of air current flowing around an object) that fall under either of the following devices (limited to those usable for developing or testing rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads over a distance of 300 kilometers or more or goods falling under item (ii), sub-item (a) or (b)):

（一）　五メガワット以上の電力を供給することができるもの

1. those capable of supplying electricity of 5 megawatts or more; or

（二）　三メガパスカル以上の圧力のガスを供給することができるもの

2. those capable of supplying gas with a pressure of 3 megapascals or more;

二十五の二　五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット、第二号イに該当する貨物（五〇〇キログラム以上のペイロードを運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。）又は同号ロに該当する貨物を設計するためのハイブリッド電子計算機（第十六条第一項第十一号に該当するプログラムを有するものに限る。）

(xxv)-2 rockets capable of transporting a payload weighing 500 kilograms or more over a distance of 300 kilometers or more, goods falling under item (ii), sub-item (a) (limited to those usable in rockets capable of transporting a payloads weighing 500 kilograms or more), or hybrid computers for designing goods falling under sub-item (b) of that item (limited to those that have programs falling under Article 16, paragraph (1), item (xi));

二十六　電波、音波（超音波を含む。）若しくは光（紫外線及び赤外線に限る。）の反射若しくは放射を減少させるステルス技術を用いた材料若しくは装置であって、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第一号の三に該当する無人航空機若しくは第二号に該当する貨物に使用することができるもの又はこれらの試験装置

(xxvi) materials or devices using stealth technology for reducing the level of reflection or emission of radio waves, sound waves (including ultrasonic waves) or light (limited to ultraviolet rays and infrared rays) which are usable in rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads over a distance of 300 kilometers or more, unmanned aircraft falling under item (i)-3, or goods falling under item (ii), or their testing devices;

二十七　集積回路、探知装置又はレードーム（五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。）であって、次のいずれかに該当するもの

(xxvii) integrated circuits, detectors, or radomes (limited to those usable in rockets or unmanned aircraft capable of transporting payloads weighing 500 kilograms or more over a distance of 300 kilometers or more) which fall under any of the following sub-items:

イ　全吸収線量がシリコン換算で五〇万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計した集積回路であって、ロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために使用することができるもの

(a) integrated circuits that are designed to be capable of withstanding radiation irradiation with a total absorbed dose of 500,000 rads or more on a silicon conversion basis, which are usable for protecting rockets or unmanned aircraft from nuclear impact;

ロ　ロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために設計した探知装置

(b) detectors that are designed to protect rockets or unmanned aircraft from nuclear impact;

ハ　五〇キロパスカルを超える圧力において一平方メートル当たり四、一八四キロジュールを超える熱衝撃に耐えることができるように設計したレードームであって、ロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために使用することができるもの

(c) radomes that are designed to be capable of withstanding a thermal shock exceeding 4,184 kilojoules per square meter at a pressure exceeding 50 kilopascals and usable for protecting rockets or unmanned aircraft from nuclear impact.

第四条　輸出令別表第一の五の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 4 The goods with specifications prescribed by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row (5) of the Appended Table 1 of the Export Order are those that fall under any of the following items:

一　ふっ素化合物の製品であって、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもののうち、第十四号ロ又はハに該当するふっ素化合物の含有量が全重量の五〇パーセントを超えるシール、ガスケット、シーラント又は燃料貯蔵袋

(i) among fluorine compound products that are designed to be used for aircraft, artificial satellites or other flying objects for space development, those that are seals, gaskets, sealants, or fuel storage bags with a content of fluorine compounds that fall under item (xiv), sub-item (b) or (c) exceeding 50% of the total weight;

二　繊維を使用した成型品（半製品を含む。以下この号において同じ。）であって、次のいずれかに該当するもの

(ii) molded products that use fibers (including semi-finished products; the same applies below in this item) which fall under any of the following products:

イ　第十五号ホに該当するプリプレグ又はプリフォームを用いて製造した成型品

(a) molded products manufactured using prepreg or preform that fall under item (xv), clause (e);

ロ　次のいずれかに該当する繊維を用いて製造した成型品であって、金属又は炭素をマトリックスとするもの

(b) molded products manufactured using fibers that fall under any of the following fibers with a matrix of metal or carbon:

（一）　炭素繊維であって次の１及び２に該当するもの

1. carbon fibers that fall under the following clauses i. and ii.:

１　比弾性率が一〇、一五〇、〇〇〇メートルを超えるもの

i. those with a specific modulus exceeding 10,150,000 meters; and

２　比強度が一七七、〇〇〇メートルを超えるもの

ii. those with a specific strength exceeding 177,000 meters;

（二）　第十五号ハに該当するもの

2. those that fall under item (xv), sub-item (c);

三　芳香族ポリイミド（熱、放射線若しくは触媒による作用その他外部からの作用による重合化又は架橋が不可能であり、かつ、熱分解を経ずに溶融することのないものに限る。）の製品（フィルム、シート、テープ又はリボン状のものに限る。）であって、次のいずれかに該当するもの（銅で被覆又はラミネートされたものであって、電子回路のプリント基板用のものを除く。）

(iii) aromatic polyimide products (limited to polyimides for which polymerization or cross-linking by action through heat, radiation or catalysts or other external action is impossible, and, which do not melt without going through pyrolysis) (limited to films, sheets, tapes, or ribbon shaped products) which fall under either of the following products (excluding those which are coated or laminated with copper and are for printed electronic circuit boards):

イ　厚さが〇・二五四ミリメートルを超えるもの

(a) those with a thickness exceeding 0.254 millimeters; or

ロ　炭素、黒鉛、金属又は磁性材料で被覆され、又はラミネートされたもの

(b) those coated or laminated with carbon, graphite, metal, or magnetic materials;

四　第二号、第十五号又は第十四条第一号に該当するものの製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品（第三条第十一号に該当するものを除く。）

(iv) devices for manufacturing things that fall under item (ii), item (xv), or Article 14, item (i), which fall under any of the following sub-items, or their components or accessories (excluding those falling under Article 3, item (xi)):

イ　フィラメントワインディング装置であって、繊維を位置決めし、包み作業及び巻き作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる基本軸（サーボ制御によって動作するものに限る。）を三本以上有するもの

(a) among filament winding devices that perform positioning of fibers, wrapping operations, and winding operations, those that have three or more basic axes (limited to those that operate by servocontrol) capable of controlling those operations in correlation;

ロ　繊維からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するためのものであって、テープを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる基本軸（サーボ制御によって動作するものに限る。）を五本以上有するもの

(b) among devices for manufacturing bodies of aircraft or the structures of rockets made of fibers, which position tapes, and perform laminating operations, those that have five or more basic axes (limited to those that operate by servocontrol) capable of controlling those operations in correlation;

ハ　三次元的に織ることができる織機又はインターレーシングマシンであって、繊

維を成型品用に織り、編み若しくは組むために特に設計又は改造したもの
(c) looms or interlacing machines capable of three-dimensional weaving, which have been specially designed or modified to weave, knit, or braid fiber for molded products;
ニ　繊維の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの
(d) fiber manufacturing devices that fall under any of the following clauses:
（一）　重合体繊維から炭素繊維又は炭化けい素繊維を製造する装置
1. devices that manufacture carbon fibers or silicon carbide fibers from polymer fibers;
（二）　炭化けい素繊維の製造用の装置であって、熱したフィラメント状の基材に元素又は化合物を化学的に蒸着させるもの
2. devices that manufacture silicon carbide fibers, which perform chemical vapor deposition of elements or compounds on heated filament-shaped base materials;
（三）　耐火セラミックの湿式紡糸装置
3. wet type spinning equipment for fire resistant ceramics;
（四）　熱処理によって、アルミニウムを含有するプリカーサー繊維からアルミナ繊維を製造する装置
4. devices that manufacture alumina fibers from precursor fibers containing aluminum by heat treatment;
ホ　ホットメルト方式を用いて第十五号ホに該当するプリプレグを製造する装置
(e) devices that manufacture prepregs that fall under item (xv), sub-item (e) by using a hot melt method;
ヘ　非破壊検査装置であって、複合材料を検査するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
(f) among non-destructive inspection devices that are designed for inspecting composite materials, those that fall under any of the following devices:
（一）　三次元欠陥検査用のエックス線断層撮影装置
1. X-ray tomography device for three-dimensional defect inspections;
（二）　数値制御を行うことができる超音波検査装置であって、位置送信機、位置受信機又は位置送受信機の動作が、同時制御され、かつ、検査時に対象物の三次元輪郭を軸数が四以上で測定するよう調整されているもの
2. ultrasonic wave testing machines capable of numerical control which the motions for positioning transmitters or receivers, or positioning transceivers are simultaneously controlled and programmed in four or more axes to follow the three dimensional contours of a component at the time of inspection;
ト　繊維からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するためのものであって、トウを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる基本軸（サーボ制御によって動作するものに限る。）を二本以上有するもの

(g) among devices for manufacturing the bodies of aircraft or structures of rockets made of fibers which position tows and perform laminating operations, those that have two or more basic axes (limited to those that operate by servocontrol) capable of controlling those operations in correlation;

五　合金の粉末又は合金の粒子状物質の製造用に設計した装置であって、次のイ及びロに該当するもの

(v) devices designed for the manufacture of alloy powders or alloy particulate matters that fall under either of the following sub-items (a) or (b);

イ　コンタミネーションを防止するように特に設計したもの

(a) those specially designed to prevent contamination; or

ロ　第七号ハ（二）１から８までのいずれかに該当する方法において使用するように特に設計したもの

(b) those specially designed to be used in any of the method that fall under item (vii), sub-item (c), 2., clauses i through xiii.

六　チタン、アルミニウム又はこれらの合金を超塑性成形又は拡散接合するための工具（型を含む。）であって、次のいずれかに該当するものを製造するように設計したもの

(vi) tools (including molds) for super plastic forming or diffusion bonding of titanium, aluminum or their alloys, which are designed to manufacture things that fall under any of the following clauses:

イ　航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体の構造体

(a) structures of aircraft, artificial satellites, and other flying objects for space development;

ロ　航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体のエンジン

(b) engines for aircraft, articial satellites, and other flying objects for space development;

ハ　イ又はロに該当するものの部分品

(c) components of those things that fall under sub-item (a) or (b);

七　合金又はその粉末であって、次のいずれかに該当するもの（コーティングに使用するために特に調合したものを除く。）

(vii) alloys or their powders that fall under any of the following sub-items (excluding those specially compounded to be used for coating):

イ　アルミニウムの化合物となっている合金であって、次のいずれかに該当するもの

(a) alloys that have become aluminum compounds, which fall under any of the following alloys:

（一）　アルミニウムの含有量が全重量の一五パーセント以上三八パーセント以下であって、アルミニウム又はニッケル以外の合金元素を含むニッケル合金

1. nickel alloys with an aluminum content of 15% or more and 38% or less of the total weight, which contain alloying elements other than of

aluminum or nickel;

（二）　アルミニウムの含有量が全重量の一〇パーセント以上であって、アルミニウム又はチタン以外の合金元素を含むチタン合金

2. titanium alloys with an aluminum content of 10% or more of the total weight, which contain alloying elements other than aluminum or titanium;

ロ　ハに該当するものからなる合金であって、次のいずれかに該当するもの

(b) alloys made of metals that fall under sub-item (c), which fall under any of the following clauses:

（一）　ニッケル合金であって、次のいずれかに該当するもの

1. nickel alloys that fall under either of the following alloys:

１　六五〇度の温度において六七六メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が一〇、〇〇〇時間以上のもの

i. those with a stress rupture time of 10,000 hours or more when a load that generates 676 megapascals stress at a temperature of 650 degrees centigrade is added;

２　五五〇度の温度において一、〇九五メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が一〇、〇〇〇サイクル以上のもの

ii. those with a low-cycle fatigue life of 10,000 cycles or more when a load that generates 1,095 megapascals stress at a temperature of 550 degrees centigrade is added;

（二）　ニオブ合金であって、次のいずれかに該当するもの

2. niobium alloys that fall under any of the following alloys:

１　八〇〇度の温度において四〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が一〇、〇〇〇時間以上のもの

i. those with a stress rupture time of 10,000 hours or more when a load that generates 400 megapascals stress at a temperature of 800 degrees centigrade is added;

２　七〇〇度の温度において七〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が一〇、〇〇〇サイクル以上のもの

ii. those with a low-cycle fatigue life of 10,000 cycles or more when a load that generates 700 megapascals stress at a temperature of 700 degrees centigrade is added;

（三）　チタン合金であって、次のいずれかに該当するもの

3. titanium alloys that fall under any of the following alloys:

１　四五〇度の温度において二〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が一〇、〇〇〇時間以上のもの

i. those with a stress rupture time of 10,000 hours or more when a load that generates 200 megapascals stress at a temperature of 450 degrees centigrade is added;

２　四五〇度の温度において四〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が一〇、〇〇〇サイクル以上のもの

ii. those with a low-cycle fatigue life of 10,000 cycles or more when a load that generates 400 megapascals stress at a temperature of 450 degrees centigrade is added;

（四）　アルミニウム合金であって、引張強さが次のいずれかに該当するもの

4. aluminum alloys with a tensile strength falling under either of the following clauses:

１　二〇〇度の温度において二四〇メガパスカル以上のもの

i. those with a tensile strength of 240 megapascals or more at a temperature of 200 degrees centigrade; or

２　二五度の温度において四一五メガパスカル以上のもの

ii. those with a tensile strength of 415 megapascals or more at a temperature of 25 degrees centigrade;

（五）　マグネシウム合金であって、引張強さが三四五メガパスカル以上のもののうち、三パーセント食塩水中における腐食が一年につき一ミリメートル未満のもの

5. among magnesium alloys with a tensile strength of 345 megapascals or more, those that incur corrosion of less than 1 millimeter per year in a 3% saline solution;

ハ　合金の粉末であって、次の（一）から（三）までの全てに該当するもの

(c) alloy powders that fall under all of the following clauses 1. through 3.:

（一）　次のいずれかに該当するものからなるもの

1. alloy powders made of materials that fall under any of the following:

１　製造工程中に混入する金属以外の粒子（径が一〇〇マイクロメートルを超えるものに限る。）の数が粒子一、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇個当たり三個未満のニッケル合金であって、アルミニウム及びニッケルを含む三種類以上の元素からなるもの

i. nickel alloys with the number of particles other than metals that are mixed in during the manufacturing process of less than three per 1,000,000,000 particles (limited to those with a diameter exceeding 100 micrometers), which are made of 3 types or more elements including aluminum and nickel;

２　アルミニウム、けい素又はチタンのいずれかの元素及びニオブを含む三種類以上の元素からなるニオブ合金

ii. niobium alloys composed of elements of any of aluminum, silicon, or titanium and three or more types of elements including niobium; or

３　アルミニウム及びチタンを含む三種類以上の元素からなるチタン合金

iii. titanium alloys composed of three or more types of elements including those of aluminum and titanium;

４　マグネシウム、亜鉛又は鉄のいずれかの元素及びアルミニウムを含む三種類以上の元素からなるアルミニウム合金

iv. aluminum alloys composed of elements of magnesium, zinc, or iron and

three or more types of elements including those of aluminum;

５　アルミニウム及びマグネシウムを含む三種類以上の元素からなるマグネシウム合金

v. magnesium alloys composed of three or more types of elements including aluminum and magnesium;

（二）　次のいずれかの方法によって製造したもの

2. alloy powders manufactured by any of the following methods:

１　真空噴霧法

i. vacuum atomization method;

２　ガス噴霧法

ii. gas atomization method;

３　回転噴霧法

iii. rotary atomization method;

４　スプラットクェンチ法

iv. splat-quenching method;

５　メルトスピニング法及び粉化法

v. melt-spinning method and pulverization method;

６　メルトエキストラクション法及び粉化法

vi. melt-extraction method and pulverization method;

７　機械的合金法

vii. mechanical alloy method; or

８　プラズマ噴霧法

vii. plasma atomization method;

（三）　イ又はロに該当するものを製造することができるもの

3. alloy powders that are capable of manufacturing those that fall under sub-item (a) or (b);

ニ　次の（一）から（三）までのすべてに該当する合金材料

(d) alloy materials that fall under all of the following clauses 1. through 3.:

（一）　ハ（一）１から５までのいずれかに該当するものからなるもの

1. those that fall under any of (c) 1., clauses i. through v.;

（二）　細かく砕かれていないフレーク状、リボン状又は細い棒状のもの

2. those that are not finely pulverized and flake shaped, ribbon shaped, or thin rod shaped;

（三）　次のいずれかの方法によって製造されたもの

3. those manufactured by any of the following methods:

１　スプラットクェンチ法

i. splat-quenching method;

２　メルトスピニング法

ii. melt spinning method; or

３　メルトエキストラクション法

iii. melt extraction method;

八　金属性磁性材料であって、次のいずれかに該当するもの

(viii) metallic magnetic materials that fall under any of the following materials:

イ　比初透磁率が一二〇、〇〇〇以上のものであって、厚さが〇・〇五ミリメートル以下のもの

(a) those with an initial relative permeability of 120,000 or more, and with a thickness of 0.05 millimeters or less;

ロ　磁歪合金であって、次のいずれかに該当するもの

(b) magnetostrictive alloys that fall under any of the following clauses:

（一）　飽和磁気歪が〇・〇〇〇五を超えるもの

1. those with a saturated magnetostriction exceeding 0.0005;

（二）　電気機械結合係数が〇・八を超えるもの

2. those with an electromechanical coupling coefficient exceeding 0.8;

ハ　ストリップ状のアモルファス合金又はナノクリスタル合金であって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(c) strip-shaped amorphous alloys or nano crystal alloys, which fall under the following clauses 1. and 2.:

（一）　鉄、コバルト若しくはニッケルのいずれかの含有量又はこれらの含有量の合計が全重量の七五パーセント以上のもの

1. those with a content of any of iron, cobalt, or nickel, or the total content of these elements, of 75% or more of the total weight;

（二）　飽和磁束密度が一・六テスラ以上のものであって、次のいずれかに該当するもの

2. those with a saturated magnetic flux density of 1.6 teslas or more, which fall under either of the following clause:

１　厚さが〇・〇二ミリメートル以下のもの

i. those with a thickness of 0.02 millimeters or less; or

２　電気抵抗率が二マイクロオームメートル以上のもの

ii. those with an electrical resistivity of 2 microohm-meters or more;

九　ウランチタン合金又はタングステン合金であって、そのマトリックスが鉄、ニッケル又は銅のもののうち、次のイからニまでのすべてに該当するもの

(ix) among uranium-titanium alloys or tungsten alloys whose matrix is iron, nickel, or copper, those that fall under all of the following sub-items (a) through (d):

イ　密度が一七・五グラム毎立方センチメートルを超えるもの

(a) those with a density exceeding 17.5 gram per cubic centimeter;

ロ　弾性限度が八八〇メガパスカルを超えるもの

(b) those with an elastic limit exceeding 880 megapascals;

ハ　引張強さが一、二七〇メガパスカルを超えるもの

(c) those with a tensile strength exceeding 1,270 megapascals; and

ニ　伸び率が八パーセントを超えるもの

(d) those with a coefficient of extension exceeding 8%;

十　超電導材料であって、次のいずれかに該当するもの（長さが一〇〇メートルを超えるもの又は全重量が一〇〇グラムを超えるものに限る。）

(x) superconducting materials that fall under any of the following sub-items (limited to those with a length exceeding 100 meters or with the total weight exceeding 100 grams):

イ　フィラメントを有するものであって、ニオブチタンのフィラメントを含むもののうち、次の（一）及び（二）に該当するもの

(a) among those that have filaments including niobium titanium filaments, those that fall under the following clauses 1. and 2.:

（一）　フィラメントが銅又は銅合金以外のマトリックスに埋めこまれたもの

1. those whose filaments are embedded in a matrix other than copper or copper alloy matrix;

（二）　フィラメントの断面積が一〇〇万分の二八平方ミリメートル未満のもの

2. those with a filament cross-section area of less than 28/1,000,000 square millimeters;

ロ　ニオブチタン以外の超電導フィラメントからなる超電導材料であって、次の（一）から（三）までのすべてに該当するもの

(b) superconductive materials composed of superconductive filaments other than niobium titanium, which fall under all of the following clauses 1. through 3.:

（一）　磁界をかけない場合に臨界温度が零下二六三・三一度超のもの

1. those with a critical temperature exceeding -263.31 degrees centigrade if a magnetic field is not applied;

（二）　削除

2. Deleted

（三）　超電導材料の縦軸に対してあらゆる方向から垂直に一二テスラの磁束密度の磁界をかけた場合に、零下二六八・九六度の温度で超電導状態を保つことができるものであって、臨界電流密度がすべての横断面で一、七五〇アンペア毎平方ミリメートルを超えるもの

3. those that can hold a superconductive state at a temperature of minus 268.96 degrees centigrade, when exposed to a magnetic field corresponding to a magnetic flux density of 12 tesla in any direction perpendicular to the vertical axis of the material, and with a critical current density exceeding 1,750 amperes per square millimeter at all the cross sections;

ハ　超電導フィラメントからなる超電導材料であって、零下一五八・一六度の温度を超えて超電導性を保つことができるもの

(c) superconductive materials composed of superconductive filaments, which is capable of holding a superconductive state at a temperature exceeding minus 158.16 degrees centigrade;

十一　潤滑剤として使用することができる材料、振動防止用に使用することができる

液体又は冷媒用の液体であって、次のいずれかに該当するもの

(xi) materials usable as lubricant, liquids usable for vibration prevention, or liquids for refrigerant, which fall under any of the following sub-items:

イ　削除

(a) Deleted

ロ　潤滑剤として使用することができる材料であって、フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェニレンチオエーテル、アルキルフェニレンチオエーテル又はこれらの混合物のうち、その有するエーテル基、チオエーテル基又はこれらの官能基の数の合計が三以上の物質を主成分とするもの

(b) materials that may be used as lubricant, among phenylene ether, alkylphenylene ether, phenylene thioether, alkyl phenylene thioether or their mixtures, those for which the total number of ether group, or thioether group, or their functional groups they possess is those that have three or more substances as the main components;

ハ　振動防止用に使用することができる液体であって、純度が九九・八パーセントを超え、かつ、径が二〇〇マイクロメートル以上の粒状の不純物の数が一〇〇ミリリットル当たり二五個未満のもののうち、次のいずれかに該当する物質の重量が全重量の八五パーセント以上のもの

(c) among liquids usable for vibration prevention with a purity exceeding 99.8%, and, with the number of particle impurities whose diameter is greater than 200 micrometers is less than 25 per 100 milliliters, those with a weight of the substances that fall under any of the following clauses is 85% or more of the total weight:

（一）　ジブロモテトラフルオロエタン

1. dibromo tetrafluoro ethane;

（二）　ポリクロロトリフルオロエチレン

2. polychloro trifluoro ethylene; or

（三）　ポリブロモトリフルオロエチレン

3. polybromo trifluoro ethylene;

ニ　電子機器の冷媒用に設計した液体であって、フルオロカーボンからなるもののうち、次の（一）及び（二）に該当するもの

(d) among liquids designed for cooling electronic devices and made of fluorocarbons, those falling under the following clauses 1. and 2.:

（一）　次のいずれかに該当する物質の含有量の合計が全重量の八五パーセント以上のもの

1. those with a total content of substances that fall under any of the following clauses are 85% or more of the total weight:

１　パーフルオロポリアルキルエーテルトリアジンのモノマー

i. monomers of perfluoro polyalkyl ether triazine;

２　パーフルオロアリファティックエーテルのモノマー

ii. monomers of perfluoro aliphatic ether;

３　パーフルオロアルキルアミン

iii. perfluoro alkylamine;

４　パーフルオロシクロアルカン

iv. perfluoro cycloalkane; or

５　パーフルオロアルカン

v. perfluoro alkane;

（二）　次の１から３までのすべてに該当するもの

2. those that fall under all of the following clauses i. through iii.:

１　二五度の温度における密度が、一ミリリットル当たり一・五グラム以上のもの

i. those with a density at the temperature of 25 degrees centigrade of 1.5 grams or more per milliliter;

２　零度の温度において液体のもの

ii. those that are liquids at the temperature of 0 degrees centigrade; and

３　ふっ素の含有量が全重量の六〇パーセント以上のもの

iii. those with a fluorine content of 60% or more of the total weight;

十二　セラミック粉末、セラミック複合材料又はセラミックの材料となる前駆物質であって、次のいずれかに該当するもの

(xii) ceramic powder, ceramic composite materials, or precursors that will be material for ceramics, which fall under any of the following sub-items:

イ　二ほう化チタンを用いて製造したセラミック粉末であって、金属不純物の含有量が全重量の〇・五パーセント未満のもののうち、粒子の径の平均値が五マイクロメートル以下であり、かつ、径が一〇マイクロメートルを超える粒子の重量の合計が全重量の一〇パーセント以下であるもの

(a) among ceramic powder manufactured using titanium diboride with a content of metallic impurities of less than 0.5% of the total weight, those for which the mean value of particle diameter is 5 micrometers or less, and, the total weight of the particles with diameters exceeding 10 micrometers is 10% or less of the total weight;

ロ　削除

(b) Deleted

ハ　セラミック複合材料であって、ガラス又は酸化物をマトリックスとするもののうち、次のいずれかに該当するもの

(c) among ceramic composite materials that have glass or oxides as matrix, those that fall under any of the following clauses:

（一）　次のいずれかからなる連続した繊維（一、〇〇〇度の温度における引張強さが七〇〇メガパスカル未満のもの、又は一、〇〇〇度の温度において一〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を一〇〇時間にわたって加えたときに、クリープ歪みが一パーセントを超えるものを除く。）により強化されたもの

1. those reinforced with continuous fiber composed of any of the following substances (excluding those with a tensile strength of less than 700

megapascals at the temperature of 1,000 degrees centigrade, or those with a creep strain exceeding 1% when a load that generates stress of 100 megapascals is added for 100 hours at the temperature of 1,000 degrees centigrade):

１　酸化アルミニウム

i. aluminum oxide; or

２　けい素、炭素及び窒素

ii. silicon, carbon, and nitrogen;

（二）　次の１及び２に該当する繊維により強化されたもの

2. those reinforced with fiber falling under the following clasues i. and ii.:

１　次のいずれかの元素の組合せからなるもの

i. those composed of combinations of any of the following elements:

一　けい素及び窒素

a. silicon and nitrogen;

二　けい素及び炭素

b. silicon and carbon;

三　けい素、アルミニウム、酸素及び窒素

c. silicon, aluminum, oxygen, and nitrogen; or

四　けい素、酸素及び窒素

d. silicon, oxygen, and nitrogen;

２　比強度が一二、七〇〇メートルを超えるもの

ii. those with a specific strength exceeding12,700 meters;

ニ　セラミック複合材料であって、けい素、ジルコニウム又はほう素の炭化物又は窒化物をマトリックスとするもの

(d) ceramic composite materials with a matrix of silicon, zirconium, boron carbide, or boron nitride;

ホ　ハ又はニのいずれかのものの製造に用いられるセラミックの材料となる前駆物質であって、次のいずれかに該当するもの

(e) precursors that will be materials for ceramics used to manufacture any of the materials referred to in sub-item (c) or (d), which fall under any of the following clauses:

（一）　ポリジオルガノシラン

1. polydiorgano silane;

（二）　ポリシラザン

2. polysilazane; or

（三）　ポリカルボシラザン

3. polycarbo silazane;

十三　重合化することができる非ふっ素化化合物又は非ふっ素化重合体であって、次のいずれかに該当するもの

(xiii) non-fluorinated compounds for which polymerization is possible, or non-fluorinated polymers, which fall under any of the following sub-items:

イ　ビスマレイミド、ガラス転移点が二九〇度を超える芳香族ポリアミドイミド、ガラス転移点が二三二度を超える芳香族ポリイミド又はガラス転移点が二九〇度を超える芳香族ポリエーテルイミド

(a) bismaleimide, aromatic polyamideimide with a glass transition point exceeding 290 degrees centigrade, aromatic polyimide with a glass transition point exceeding 232 degrees centigrade, or aromatic polyetherimides with a glass transition point exceeding 290 degrees centigrade;

ロ　削除

(b) Deleted

ハ　削除

(c) Deleted

ニ　ポリアリーレンケトン

(d) polyallylene ketone;

ホ　ビフェニレン、トリフェニレン又はこれらの組合せからなるアリーレン基を有するポリアリーレンスルフィド

(e) polyallylene sulfide that have allylene groups composed of biphenylene, tri phenylene, or their combination;

ヘ　ガラス転移点が二九〇度を超えるポリビフェニレンエーテルスルホン

(f) polybiphenylene ether sulfone with a glass transition point exceeding 290 degrees centigrade;

十四　ふっ素化合物であって、次のいずれかに該当するもの

(xiv) fluorine compounds that fall under any of the following sub-items:

イ　削除

(a) Deleted

ロ　結合ふっ素の含有量が全重量の一〇パーセント以上のふっ化ポリイミド

(b) fluorinated polyimides with bonded fluorine content of 10% or more of the total weight;

ハ　結合ふっ素の含有量が全重量の三〇パーセント以上のふっ化ホスファゼンの弾性体

(c) elastic bodies of fluorinated phosphazenes with bonded fluorine content of 30% or more of the total weight;

十五　繊維又はこれを使用したプリプレグ若しくはプリフォームであって、次のいずれかに該当するもの

(xv) fibers, or prepregs or preforms that use those fibers, which fall under any of the following sub-items:

イ　有機繊維（ポリエチレン繊維を除く。）であって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(a) organic fibers (excluding polyethylene fibers), which fall under any of the following clauses 1. and 2.:

（一）　比弾性率が一二、七〇〇、〇〇〇メートルを超えるもの

1. those with a specific modulus exceeding 12,700,000 meters;

（二）　比強度が二三五、〇〇〇メートルを超えるもの

2. those with a specific strength exceeding 235,000 meters;

ロ　炭素繊維であって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(b) carbon fibers that fall under the following clauses 1. and 2.:

（一）　比弾性率が一四、六五〇、〇〇〇メートルを超えるもの

1. those with a specific modulus exceeding 14,650,000 meters;

（二）　比強度が二六八、二〇〇メートルを超えるもの

2. those with a specific strength exceeding 268,200 meters;

ハ　無機繊維であって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(c) inorganic fibers that fall under the following clauses 1. and 2.:

（一）　次のいずれかに該当するもの

1. those falling under either of the following clauses:

１　二酸化けい素の含有量が全重量の五〇パーセント以上であって、比弾性率が二、五四〇、〇〇〇メートルを超えるもの

i. those with a silicon dioxide content of 50% or more of the total weight, with a specific modulus exceeding 2,540,000 meters; or

２　比弾性率が五、六〇〇、〇〇〇メートルを超えるもの（１に該当するものを除く。）

ii. those with a specific modulus exceeding 600,000 meters (excluding those falling under clause i.).

（二）　不活性の環境における融点、軟化点、分解点又は昇華温度が一、六四九度を超えるもの。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

2. those with a melting point, softening point, decomposition point, or sublimation temperature exceeding 1,649 degrees centigrade, in an inert environment; provided, however, excluding those that fall under any of the following clauses:

１　比弾性率が一〇、〇〇〇、〇〇〇メートル未満のものであって、シリカの含有量が全重量の三パーセント以上の多相多結晶アルミナ繊維の短繊維であって、短く切断されたもの又はランダムマット形態のもの

i. those with a specific modulus of less than 10,000,000 meters, which are short fibers of multiphase polycrystalline alumina fibers with a silica content of 3% or more of the total weight and are cut into short pieces or are random mat shaped;

２　モリブデン繊維又はモリブデン合金繊維

ii. molybdenum fibers or molybdenum alloy fibers; or

３　ボロン繊維

iii. boron fibers;

４　不活性の環境における融点、軟化点、分解点又は昇華温度が一、七七〇度未満のセラミック繊維の短繊維

iv. short fibers of ceramic fibers with a melting point, softening point,

decomposition point, or sublimation temperature exceeding 1,770 degrees centigrade, in an inert environment;

ニ　次のいずれかに該当するものからなる繊維又は当該繊維とイからハまでのいずれかに該当する繊維とを混繊した繊維

(d) fibers made of the things that fall under any of the following clauses, or fibers woven by mixing those fibers and fibers that fall under any of the following sub-items (a) through (c):

（一）　第十三号イに該当する芳香族ポリエーテルイミド

1. aromatic polyetherimides that fall under item (xiii), sub-item (a);

（二）　第十三号ニからへまでのいずれかに該当するもの

2. those that fall under any of item (xiii), sub-items (d) through (f);

ホ　プリプレグ又はプリフォームであって、次の（一）及び（二）を使用したもの

(e) prepregs or preforms that use the following things under 1. and 2.:

（一）　次の１又は２に該当するもの

1. those which fall under the following clause i. or ii.:

１　ハに該当する無機繊維

i. inorganic fibers that fall under clause (c);

２　有機繊維又は炭素繊維であって、次の一及び二に該当するもの

ii. organic fibers or carbon fibers that fall under the following clauses a. and b.:

一　比弾性率が一〇、一五〇、〇〇〇メートルを超えるもの

a. those with a specific modulus exceeding 10,150,000 meters;

二　比強度が一七七、〇〇〇メートルを超えるもの

b. those with a specific strength exceeding 177,000 meters;

（二）　次のいずれかに該当する樹脂

2. resins that fall under any of the following clauses:

１　第十三号又は第十四号ロに該当するもの

i. those that fall under item (xiii) or item (xiv), sub-item (b) with a glass transition point exceeding 110 degrees centigrade;

２　フェノール樹脂であって、動的機械分析によって測定したガラス転移点が一八〇度以上のもの

ii. phenol resin with a glass transition point of 180 degrees centigrade or more when measured by dynamic mechanical analysis;

３　動的機械分析によって測定したガラス転移点が二三二度以上のもの（フェノール樹脂及び１に該当するものを除く。）

iii. those with a glass transition point of 232 degrees centigrade or more when measured by dynamic mechanical analysis (excluding phenol resins and those falling under clause i.);

十六　粒子の径が六〇マイクロメートル以下のほう素であって、ほう素の重量比による純度が八五パーセント以上のもの若しくはその混合物、粒子の径が六〇マイクロメートル以下のほう素合金であって、ほう素の重量比が八五パーセント以上のもの

若しくはその混合物、硝酸グアニジン又はニトログアニジン

(xvi) boron with a particle diameter of 60 micrometers or less with a weight-based purity level of boron of 85% or more or their mixture, boron alloy with a particle diameter of 60 micrometers or less and with a weight-based purity level of boron of 85% or more or their mixture, guanidine nitrate, or nitro guanidine.

第五条　輸出令別表第一の六の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 5 The goods with specifications prescribed by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 6 of the Appended Table 1 of the Export Order are those that fall under any of the following items:

一　軸受又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(i) axis bearings or their components, which fall under any of the following sub-items:

イ　玉軸受又はころ軸受（円すいころ軸受を除く。）であって、内輪、外輪及び転動体の全てがモネル製又はベリリウム製のもののうち、日本産業規格Ｂ一五一四―一号で定める精度の等級が二級又は四級以上のもの

(a) among ball bearings or roller bearings (excluding tapered roller bearings) whose inner ring, outer ring and rolling element are all made of monel or beryllium, those whose precision ranking specified by the Japanese Industrial Standard No. B1514-1 is higher than Class II or Class IV;

ロ　削除

(b) Deleted

ハ　能動型の磁気軸受システムであって、次のいずれかに該当するもの又はそのために特に設計した部分品

(c) active magnetic bearing system that falls under any of the following systems or components that were specially designed for that purpose:

（一）　磁束密度が二テスラ以上で、かつ、降伏点が四一四メガパスカルを超える材料からなるもの

1.those that are composed of materials with a magnetic flux density of 2 teslas or more, and, a yield point exceeding 414 megapascals;

（二）　全電磁式で、かつ、三次元ホモポーラバイアス励磁方式のアクチュエータを用いるもの

2. those that are all-electromagnetic systems and use a three-dimensional homopolar bias excitation actuator;

（三）　温度が一七七度以上で用いることができる位置検出器を有するもの

3. those that have a position detector that can be used at the temperature of 177 degrees centigrade or more;

二　工作機械（金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。）であって、電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイから

ホまでのいずれかに該当するもの（へに該当するもの及び光学仕上げ工作機械を除く。）

(ii) among machine tools (limited to those that are capable of processing metals, ceramics, or composite materials) to which an electronic control device may be attached, those that fall under any of the following sub-items (a) through (e) (excluding those that fall under sub-item (f) and optical finishing machine tools):

イ　旋削をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもののうち、次のいずれかに該当するもの（（三）に該当するものを除く。）

(a) among machine tools capable of lathe turning and have two or more shafts capable of contouring control, those which fall under any of the following clauses (excluding those that fall under clause 3.):

（一）　移動量が一メートル未満の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇〇九ミリメートル以下のもの

1. among straight axes whose movement is less than 1 meter, those which the repeatability of the unidirectional positioning of any one or more axes is 0.0009 millimeters or less;

（二）　移動量が一メートル以上の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一一ミリメートル以下のもの

2. among straight axes whose movement amount is 1 meter or more, those with a repeatability of the unidirectional positioning of any one or more axes is 0.0011 millimeters or less

（三）　棒材作業用の旋盤のうち、スピンドル貫通穴から材料を差し込み加工するものであって、次の１及び２に該当するもの

3. among bar work lathes those for which materials are inserted from a spindle hole for processing, which fall under the following clauses i. and ii.:

１　加工できる材料の最大直径が四二ミリメートル以下のもの

i. those capable of processing materials whose maximum diameter is 42 millimeters;

２　チャックを取り付けることができないもの

ii.those to which a chuck cannot be installed;

ロ　フライス削りをすることができる工作機械であって、次のいずれかに該当するもの

(b) machine tools capable of milling, which fall under any of the following clauses:

（一）　輪郭制御をすることができる直線軸の数が三で、かつ、輪郭制御をすることができる回転軸の数が一のものであって、次のいずれかに該当するもの

1. those that have three straight axes capable of contouring control, and, one rotating axis capable of contouring control, which fall under either of the following clauses:

１　移動量が一メートル未満の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇〇九ミリメートル以下のもの
i. among straight axes whose movement amount is less than 1 meter, those with a repeatability of the unidirectional positioning of any one or more axes is 0.0009 millimeters or less; or
２　移動量が一メートル以上の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一一ミリメートル以下のもの
ii. among straight axes whose movement amount is 1 meter or more, those with a repeatability of the unidirectional positioning of any one or more axes is 0.0011 millimeters or less;
（二）　輪郭制御をすることができる軸数が五以上のものであって、次のいずれかに該当するもの
2. among those with five or more axes capable of controlling contour, those that fall under any of the following clauses:
１　移動量が一メートル未満の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇〇九ミリメートル以下のもの
i. among straight axes whose movement amount is less than 1 meter, those with a repeatability of the unidirectional positioning of any one or more axes is 0.0009 millimeters or less;
２　移動量が一メートル以上四メートル未満の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一四ミリメートル以下のもの
ii. among straight axes whose movement amount is 1 meter or more and less than 4 meters, those with a repeatability of the unidirectional positioning of any one or more axes is 0.0014 millimeters or less; or
３　移動量が四メートル以上の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇六ミリメートル以下のもの
iii. among straight axes whose movement amount is 4 meters or more, those with a repeatability of the unidirectional positioning of any one or more axes is 0.006 millimeters or less;
（三）　ジグ中ぐり盤であって、いずれか一軸以上の直線軸の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一一ミリメートル以下のもの
3. jig boring machines with a repeatability of the unidirectional positioning of any one or more straight axes is 0.0011 millimeters or less;
（四）　フライカッティングを行うように専用設計された工作機械であって、次の１及び２に該当するもの
4. machine tools exclusively designed for fly cutting, which fall under the following clauses i. and ii.:
１　スピンドルを一回転させた場合におけるスピンドルの半径方向及び軸方向の振れがそれぞれ〇・〇〇〇四ミリメートル未満のもの
i. those for which the deflection in the radial direction and the deflection in the axial direction are less than 0.0004 millimeters when the spindle is

rotated once; and

２　三〇〇ミリメートルを超える移動距離における真直度が二秒未満のもの

ii. those with the straightness of less than 2 seconds for the movement distance exceeding 300 millimeters;

ハ　研削をすることができる工作機械であって、次のいずれかに該当するもの（次の（三）から（五）までのいずれかに該当するものを除く。）

(c) machine tools capable of grinding that fall under any of the following clauses (excluding those which fall under any of the clauses 3. through 5.):

（一）　いずれか一軸以上の直線軸の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一一ミリメートル以下のものであって、輪郭制御をすることができる軸数が三又は四のもの

1. those with a repeatability of the unidirectional positioning of any one or more axes of the straight axes is 0.0011 millimeters or less, which have three or four axes capable of contouring control;

（二）　輪郭制御をすることができる軸数が五以上のものであって、次のいずれかに該当するもの

2. among those with five or more axes capable of controlling contour, those which fall under any of the following clauses:

１　移動量が一メートル未満の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一一ミリメートル以下のもの

i. among straight axes whose movement amount is less than 1 meter, those with a repeatability of the unidirectional positioning of any one or more axes is 0.0011 millimeters or less;

２　移動量が一メートル以上四メートル未満の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一四ミリメートル以下のもの

ii. among straight axes whose movement amount is 1 meter or more and less than 4 meters, those with a repeatability of the unidirectional positioning of any one or more axes is 0.0014 millimeters or less; or

３　移動量が四メートル以上の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇六ミリメートル以下のもの

iii. among straight axes whose movement is 4 meters or more, those with a repeatability of the unidirectional positioning of any one or more axes is 0.006 millimeters or less;

（三）　円筒外面研削盤、円筒内面研削盤又は円筒内外面研削盤であって、円筒で外径又は長さが一五〇ミリメートル以内のものを研削するように設計したもの

3. external cylindrical grinders, internal cylindrical grinders, or internal-external cylindrical grinders which are designed to grind a cylinder with an external diameter or length of less than 150 millimeters;

（四）　ジグ研削盤として使用するように設計した工作機械であって、一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一一ミリメートル未満のＺ軸又はW軸を有しないもの

4. machine tools which are designed to be used as a jig grinding machine, which do not have a Z axis or W axis with a repeatability of the unidirectional positioning of less than 0.0011 millimeters;

（五）　平面研削盤

5. flat surface grinders;

ニ　放電加工（ワイヤ放電加工を除く。）をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの

(d) machine tools capable of electrical discharge machining (excluding wire electrical discharge machining) with two or more rotational axes capable of controlling contour;

ホ　液体ジェット加工をすることができる工作機械、電子ビーム加工機又はレーザー加工機であって、次の（一）及び（二）に該当する回転軸の数が少なくとも二以上のもの

(e) machine tools capable of liquid jet prcessing, electron beam machines, or laser processing machines, which have at least two or more rotational axes that fall under the following clause 1. or 2.:

（一）　輪郭制御をすることができるもの

1. those capable of controlling contour;

（二）　回転軸の位置決め精度が〇・〇〇三度未満のもの

2. those with a positioning precision of the rotating axis of less than 0.003 degrees;

ヘ　工作機械であって、次のいずれかを製造するためのみに使用するように設計したもの

(f) machine tools that are exclusively designed to manufacture any of the following tools:

（一）　歯車

1. gears;

（二）　クランク軸又はカム軸

2. crank shafts or cam shafts;

（三）　工具又は刃物

3. tools or blades;

（四）　押出機のウォーム

4. extruder worms;

（五）　宝石

5. gemstones; or

（六）　義歯

6. dentures;

三　工作機械（金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。）であって、電子制御装置を取り付けることができるもののうち、深穴ボール盤若しくは旋削をすることができるもの（深穴あけをすることができるものに限る。）で、深さが五、〇〇〇ミリメートルを超える穴をあけることができるもの

(iii) among machine tools (limited to those that can process metals, ceramics, or composite materials) to which an electronic control device can be attached, those that are capable of deep bore drilling or lathe turning (limited to those that are capable of deep bore drilling), which can bore a hole with a depth exceeding 5,000 millimeters;

四　数値制御を行うことができる光学仕上げ工作機械であって、選択的に材料を除去することにより非球形な光学的表面に加工することができるもののうち、次のイからニまでの全てに該当するもの

(iv) among optical finishing machine tools capable of numerical control and capable of processing the surface to nonspherical optical surfaces by selectively removing materials, those which fall under all of the following sub-items (a) through (d):

イ　仕上がり形状寸法公差が一・〇マイクロメートル未満のもの

(a) those with the dimensional tolerance of the finished shape of less than 1.0 micrometers;

ロ　仕上げの表面粗さの二乗平均平方根が一〇〇ナノメートル未満のもの

(b) those with a root mean square of less than 100 nanometers for the finished surface roughness;

ハ　輪郭制御をすることができる軸数が四以上のもの

(c) those with four or more axes capable of controlling contour; and

ニ　次のいずれかの方法を用いるもの

(d) those using any of the following methods:

（一）　磁性流体研磨法

1. magnetorheological polishing method;

（二）　電気粘性流体研磨法

2. electrorheological polishing method;

（三）　エネルギー粒子ビーム研磨法

3. polishing method using energetic particle beams;

（四）　膨張膜研磨法

4. inflatable membrane tool finishing method; or

（五）　流体ジェット研磨法

5. fluid jet polishing method;

五　日本産業規格Ｚ二二四五号（ロックウェル硬さ試験方法）で定める測定方法によりＣスケールで測定したロックウェル硬さが四〇以上である平歯車、はすば歯車又はやまば歯車を仕上げ加工するよう設計した数値制御を行うことができる工作機械であって、次のイからハまでの全てに該当するものを加工することができるもの

(v) machine tools capable of numerical control that are designed to perform finishing processing of spur gears, helical gears, or double-helical gears with a Rockwell hardness of 40 or greater measured using the C scale by the measurement method specified by Japanese Industrial Standard Z2245 (Rockwell hardness test method), which are capable of processing machine

tools that fall under all of the following sub-items (a) through (c):

イ　ピッチ円直径が一、二五〇ミリメートルを超えるもの

(a) those with a pitch diameter exceeding 1,250 millimeters;

ロ　歯幅がピッチ円直径の一五パーセント以上のもの

(b) those with a face width of 15% or larger of the pitch diameter;

ハ　国際規格ＩＳＯ一三二八（円筒歯車―ＩＳＯ方式による精度）で定める精度が三級以上のもの

(c) those with a precision specified by the International Standard ISO 1328 (precision under the ISO method for cylindrical gears);

六　アイソスタチックプレスであって、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品若しくは附属品

(vi) isostatic presses that fall under the following sub-items (a) and (b), or their components or accessories:

イ　内径が四〇六ミリメートル以上の中空室を有するものであって、中空室内の温度制御ができるもの

(a) those that have hollow cavities with an internal diameter of 406 millimeters or more and capable of controlling temperature inside the hollow cavities; and

ロ　次のいずれかに該当するもの

(b) those that fall under any of the following clauses:

（一）　最大圧力が二〇七メガパスカルを超えるもの

1. those with a maximum pressure exceeding 207 megapascals;

（二）　中空室内の温度を一、五〇〇度を超える温度に制御することができるもの

2. those capable of controlling temperatures inside hollow cavities to a temperature exceeding 1,500 degrees centigrade; or

（三）　炭化水素の注入のための装置及びガス状分解生成物を除去するための装置を有するもの

3. those that have devices for injecting hydrocarbons, and for removing gaseous decomposition products;

七　別表第三の第二欄に掲げるコーティング方法を用いる非電子的基板用コーティング装置であって、同表の第三欄に掲げる基材に対して同表の第四欄に掲げるコーティングを行うもののうち、次のいずれかに該当するもの又はその自動操作のために特に設計した部分品

(vii) among coating devices for non-electronic substrates which use the coating method stated in column 2 of the Appended Table 3 and apply the coatings stated in column 4 of that Table on base materials stated in column 3 of that Table, those that fall under any of the following sub-items, or components specially designed for their automatic operation:

イ　原料ガスの化学反応により生成するコーティング材料を基材の表面に定着させる方法を用いるものであって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(a) those that use the method of fixing to the surface of base materials coating materials that are produced by chemical reaction of source gas, which fall under the following clauses 1. and 2.:

（一）　次のいずれかの方法を用いるもの

1. those that use any of the following methods:

１　パルス的方法

i. pulse method;

２　核生成制御熱化学的析出法

ii. controlled nucleation thermochemical deposition method; or

３　プラズマ放電下においてコーティング材料を基材の表面に定着させる方法

iii. methods that fix coating materials to the surface of base materials by plasma discharge;

（二）　次のいずれかに該当するもの

2. those that fall under either of the following clauses:

１　一〇ミリパスカル以下で使用することができる回転軸シールを組み込んだもの

i. those that have rotational axis seals that can be used at 10 millipascals or less incorporated; or

２　膜厚制御機能を内部に有しているもの

ii. those that have a film thickness control function inside;

ロ　イオン注入法を用いるものであって、ビーム電流が五ミリアンペア以上のもの

(b) those that use the ion implantation method and have a beam current of 5 milliamperes or more;

ハ　電子ビームにより蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法を用いるものであって、容量が八〇キロワットを超える電源装置を組み込んだもののうち、次のいずれかに該当する装置を有するもの

(c) among those that use the method of fixing coating materials that have been vaporized by electron beams to the surface of base materials, for which power supply devices with a capacity exceeding 80 kilowatts have been incorporated, those that have the devices falling under any of the following clauses:

（一）　インゴットの送りを制御するために、溶融液の液面制御をレーザー光を用いて行う装置

1. devices that conduct molten liquid level control by using laser light to control feeding of ingot;

（二）　コンピュータを用いて制御することができる溶着速度の監視装置であって、二以上の元素をコーティングする際の溶着速度を制御するために蒸気流中におけるイオン化原子のホトルミネセンスの原理を利用するもの

2. deposition rate monitoring devices that are capable of control by using computers, which uses the principle of photoluminescence of ionized atoms in vapor flow to control the deposition rate when applying coating of two or

more elements;

ニ　プラズマ溶射をするものであって、次のいずれかに該当するもの

(d) those that carry out plasma spraying which fall under the following devices:

（一）　溶射前に真空室を一〇ミリパスカルまで減圧することができるものであって、一〇キロパスカル以下の圧力（ノズル出口から三〇センチメートル以内において測定したものをいう。）で使用することができるもの

1. those that can reduce the pressure in vacuum chambers to 10 millipascals before thermal spraying, which may be used at a pressure of 10 kilopascals or less (meaning those measured within 30 centimeters from the mouth of the nozzle);

（二）　膜厚制御機能を内部に有しているもの

2. those that have a film thickness control function inside;

ホ　スパッタリング法を用いるものであって、毎時一五マイクロメートル以上の溶着速度における電流密度が一〇ミリアンペア毎平方センチメートル以上のもの

(e) those that use the sputtering method and have a current density of 10 milliamperes per square centimeter or more for deposition rate of 15 micrometers per hour or more;

ヘ　アーク放電によりイオン化されたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法を用いるものであって、陰極上のアークスポットを制御するための磁界を有するもの

(f) those that use the method of fix coating materials ionized by arc discharge to the surface of base materials, which have a magnetic field for controlling arc spots on the cathode;

ト　イオンプレーティング生産装置であって、コーティング中に次のいずれかを測定することができるもの

(g) ion plating production equipment that can measure any of the following matters during coating:

（一）　基材の表面に定着したコーティング材料の厚さ及び成膜速度

1. thickness and deposition rate of coating materials fixed to the surface of base materials;

（二）　基材の表面の光学的特性

2. optical properties of the surface of base materials;

八　測定装置（工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。以下この条において同じ。）、位置のフィードバック装置又は測定装置の組立品であって、次のいずれかに該当するもの（第二号又は第三号に該当するものを除く。）

(viii) measuring devices (including machine tools usable as a measuring device; the same applies below in this Article), feedback devices for positions, or assemblies of measuring devices, which fall under any of the following sub-items (excluding those falling under item (ii) or (iii)):

イ　電子計算機又は数値制御装置によって制御される座標測定機であって、国際規格で定める測定方法により空間の測定精度を測定した場合に、操作範囲内のいずれかの測定点において、測定軸のマイクロメートルで表した最大許容長さ測定誤差がミリメートルで表した当該測定軸の長さに〇・〇〇一を乗じて得た数値に一・七を加えた数値以下となるもの

(a) coordinate measuring machines that are controlled by a computer or numerical control equipment, for which the numerical value of the maximum permissible error of the length of the measuremen axis expressed in micrometers is to be equal to or less than the numerical value to which 1.7 is added to the numerical value obtained by multiplying the length of the measurement axis expressed in millimeters by 0.001, when the measurement accuracy of space is measured by the measurement method specified by an international standard, at any of the measuring points within the operating range;

ロ　直線上の変位を測定する装置、直線上の位置のフィードバック装置又は測定装置の組立品であって、次のいずれかに該当するもの（（一）及び（二）にあっては、レーザー干渉計及びレーザーを用いた光学エンコーダを除く。）

(b) devices for measuring displacement on a straight line, feedback devices for positions on a straight line, or assemblies of measuring devices, which fall under any of the following clauses (for clauses 1. and 2., excluding laser interferometers and optical encoders using lasers):

（一）　非接触型の測定装置であって、〇・二ミリメートルまでの測定レンジにおいて、分解能が〇・二マイクロメートル以下のもの

1. non-contact type measurement device with a resolving power of 0.2 micrometers or less in a measurement range of up to 0.2 millimeters;

（二）　工作機械用に特に設計した直線上の位置のフィードバック装置であって、当該装置の精度がミリメートルで表した当該装置の有効測定長さの十万分の六パーセントに〇・〇〇八ミリメートルを加えて得た数値未満のもの

2. a feedback device for positions on a straight line, which is specially designed for machine tools with a precision of less than the numerical value obtained by adding 0.0008 millimeters to 6/100,000th percent of the effective measurement length of the devices expressed in millimeters; or

（三）　次の全てに該当するもの

3. devices falling under all of the following clauses:

１　レーザー光を用いて測定することができるもの

i. those capable of measurement by using a laser beam;

２　測定できる最大の測定レンジにおいて、分解能が〇・二ナノメートル以下のもの

ii. those with a resolving power of 0.2 nanometers or less in the maximum measurable range; and

３　測定範囲内のいずれか一の点において、空気屈折率で補正した場合に、測定

軸のナノメートルで表した測定の不確かさの数値がミリメートルで表した当該測定軸の長さに〇・〇〇〇五を乗じて得た数値に一・六を加えた数値以下のものであって、一九・九九度以上二〇・〇一度以下の温度範囲において三〇秒を超えて測定できるもの

iii. those for which the numerical value of measurement uncertainty for the measurement axis expressed in nanometers is equal to or less than the numerical value obtained by adding 1.6 to the numerical value obtained by multiplying the length of the measurement axis expressed in millimeters by 0.0005 at any of the measuring points within the operating range when corrected by air refractive index, which are capable of conducting measurement for more than 30 seconds in the temperatures range between 19.99 degrees centigrade or more and 20.01 degrees centigrade or less;

（四）　（三）に該当する測定装置の組立品であって、当該装置にフィードバック機能を付加するように設計したもの

4. assemblies of a measuring device falling under clause 3., which are designed to add a feedback function to the device;

ハ　工作機械用に特に設計した回転位置フィードバック装置又は角度の変位を測定する装置であって、角度の精度が〇・九角度秒以下のもの（平行光線を用いて鏡の角度の変位を測定する光学的器械（オートコリメータを含む。）を除く。）

(c) rotational position feedback devices or devices for measuring angle displacement, which are specially designed for machine tools, with an angular accuracy of 0.9 arc seconds or less (excluding optical instruments for measuring displacement of the angle of a mirror by using parallel rays (including autocollimators));

ニ　光の散乱を角度の関数として処理することにより表面粗さを測定するものであって、〇・五ナノメートル以下の感度を有するもの

(d) devices that measure surface roughness by treating the light scattering as function of angles, which have a sensitivity of 0.5 nanometers or less;

九　ロボット（操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。）であって、次のいずれかに該当するもの又はその制御装置若しくはエンドエフェクター

(ix) robots (excluding operating robots and sequenced robots) that fall under any of the following robots, or their control device or end effector:

イ　日本産業規格Ｃ六〇〇七九―〇号で定める防爆構造のもの（塗装用のものを除く。）

(a) those with explosion-proof structure specified by Japanese Industrial Standard C60079-0 (excluding those used for painting);

ロ　全吸収線量がシリコン換算で五、〇〇〇グレイを超える放射線照射に耐えることができるように設計したもの

(b) those that are designed to withstand a total absorbed dose of radiation irradiation exceeding 5,000 grays on a silicon conversion basis;

ハ　三〇、〇〇〇メートルを超える高度で使用するように設計したもの

(c) those that are designed for use at altitudes exceeding 30,000 meters;

十　複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドルであって、工作機械用に設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの

(x) among compound rotary tables or spindles that can change the angle of the center line for other axes during manufacturing which are designed for machine tools, those that fall under any of the following sub-items:

イ　削除

(a) Deleted

ロ　削除

(b) Deleted

ハ　複合回転テーブルであって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(c) compound rotary tables that fall under the following clauses 1. and 2.:

（一）　旋削、フライス削り又は研削をすることができる工作機械用に設計したもの

1. those that are designed for machine tools capable of lathe turning, milling, or grinding; and

（二）　輪郭制御のために同時に制御することができるように設計した二つの回転軸を有するもの

2. those that have two rotating axes designed to enable simultaneous control for contouring control;

ニ　加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドルであって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(d) spindles that can change the angle of the center line for other axes during manufacturing, which fall under the following clauses 1. and 2.:

（一）　旋削、フライス削り又は研削をすることができる工作機械用に設計したもの

1. those that are designed for machine tools capable of lathe turning, milling, or grinding; and

（二）　輪郭制御のために同時に制御することができるように設計したもの

2. those that are designed to enable simultaneous control for contouring control;

十一　絞りスピニング加工機であって、次のイ、ロ及びハの全てに該当するもの

(xi) spin-forming machines that fall under all of the following sub-items (a), (b), and (c):

イ　数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもの

(a) those that can be controlled by a numerical control equipment or computer;

ロ　輪郭制御をすることができる軸数が三以上のもの

(b) those with three or more axes capable of controlling contour;

ハ　ローラの加圧力が六〇キロニュートンを超えるもの

(c) those whose roller has a welding force exceeding 60 kilonewtons.

第六条　輸出令別表第一の七の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 6 The goods with specifications prescribed by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 7 of the Appended Table 1 of the Export Order are those that fall under any of the following items:

一　集積回路（モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路、マルチチップ集積回路、膜形集積回路（シリコンオンサファイア集積回路を含む。）、光集積回路、三次元集積回路及びモノリシックマイクロ波集積回路を含む。）であって、次のいずれかに該当するもの

(i) integrated circuits (including monolithic integrated circuits, hybrid integrated circuits, multichip integrated circuits, film integrated circuits (including silicon-on-sapphire integrated circuits), optical integrated circuits, three-dimensional integrated circuits, and monolithic microwave integrated circuits) that fall under any of the following sub-items:

イ　次のいずれかの放射線照射に耐えられるように設計したもの

(a) those that are designed to withstand any of the following radiation irradiation:

（一）　全吸収線量がシリコン換算で五、〇〇〇グレイ以上のもの

1. those with a total absorbed dose of 5,000 grays or more on a silicon conversion basis;

（二）　吸収線量がシリコン換算で一秒間に五、〇〇〇、〇〇〇グレイ以上のもの

2. those with an absorbed dose of 5,000,000 grays or more on a silicon conversion basis in one second;

（三）　一メガ電子ボルト相当の中性子束（積算値）が一平方センチメートル当たり五〇兆個以上となるもの（ＭＩＳ形のものは除く。）

3. those with a neutron flux corresponding to 1 megaelectron volt (integrated value) of 50 trillion or more per square centimeter (excluding MIS types);

ロ　マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、マイクロコントローラ、化合物半導体を用いた記憶素子用のもの、アナログデジタル変換用のもの、アナログデジタル変換機能を有しデジタル化されたデータを記録し、若しくは処理することができるもの、デジタルアナログ変換用のもの、信号処理用の電気光学的集積回路若しくは光集積回路、フィールドプログラマブルロジックデバイス、カスタム集積回路（ハからチまで若しくはルからワまでのいずれかに該当する貨物であるかどうかの判断をすることができるもの又は輸出令別表第一の五から一五までの項の中欄のいずれかに該当する貨物に使用するように設計したものであるかどうかの判断をすることができるものを除く。以下この条において同じ。）、ＦＦＴプロセッサ、スタティック式のラム又は不揮発性メモリーであって、次のいずれ

かに該当するもの（民生用の自動車又は鉄道車両用に設計した集積回路を除く。）

(b) microprocessors, microcomputers, microcontrollers, those for memory elements using compound semiconductors, those for analog-to-digital conversion, those that have an analog-to-digital conversion function and capable of recording or processing digitized data, those for digital-to-analog conversion, electrooptical integrated circuits or optical integrated circuits for signal processing, field programmable logic devices, custom integrated circuits (excluding those that are possible to determine whether or not they are goods that fall under any of sub-items (c) through (h) or sub-items (k) through (m) or those that can be determined whether they are designed to be used for goods falling under any of the middle column of rows (5) through (15) of the Appended Table 1 of the Export Order; the same applies below in this Article), FFT processors, static RAM or nonvolatile memories, which fall under any of the following clauses (excluding integrated circuits designed for automobiles or railway vehicles for civilian use):

（一）　一二五度を超える温度で使用することができるように設計したもの

1. those that are designed for use at temperatures exceeding 125 degrees centigrade;

（二）　零下五五度未満の温度で使用することができるように設計したもの

2. those that are designed for use at temperatures of less than minus 55 degrees centigrade;

（三）　零下五五度以上一二五度以下のすべての温度範囲で使用することができるように設計したもの

3. those designed for use at all temperature ranges between minus 55 degrees centigrade or more and 125 degrees centigrade or less;

ハ　マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ又はマイクロコントローラのうち、化合物半導体を用いたものであって、最大クロック周波数が四〇メガヘルツを超えるもの

(c) among microprocessors, microcomputers, or microcontrollers, those that use compound semiconductors with a maximum clock frequency exceeding 40 megahertz;

ニ　削除

(d) Deleted

ホ　アナログデジタル変換用のもの又はデジタルアナログ変換用のものであって、次のいずれかに該当するもの

(e) those for analog-to-digital conversion or digital-to-analog conversion, which fall under any of the following clauses:

（一）　アナログデジタル変換用のものであって、次のいずれかに該当するもの（ワに該当するものを除く。）

1. those for analog-to-digital conversion which fall under any of the following clauses (excluding those falling under clause (m)):

１　分解能が八ビット以上一〇ビット未満のものであって、サンプルレートが一・三ギガサンプリング毎秒を超えるもの

i. those with a resolving power of 8 bits or more and less than 10 bits and a sample rate exceeding 1.3 gigasamples per second

２　分解能が一〇ビット以上一二ビット未満のものであって、サンプルレートが六〇〇メガサンプリング毎秒を超えるもの

ii. those with a resolving power of 10 bits or more and less than 12 bits and with a sample rate exceeding 600 megasamples per second;

３　分解能が一二ビット以上一四ビット未満のものであって、サンプルレートが四〇〇メガサンプリング毎秒を超えるもの

iii. those with a resolving power of 12 bits or more and less than 14 bits and a sample rate exceeding 400 megasamples per second;

４　分解能が一四ビット以上一六ビット未満のものであって、サンプルレートが二五〇メガサンプリング毎秒を超えるもの

iv. those with a resolving power of 14 bits or more and less than 16 bits and a sample rate exceeding 250 megasamples per second;

５　分解能が一六ビット以上のものであって、サンプルレートが六五メガサンプリング毎秒を超えるもの

v. those with a resolving power of 16 bits or more and a sample rate exceeding 65 megasamples per second;

（二）　デジタルアナログ変換用のものであって、次のいずれかに該当するもの

2. those for digital-to-analogue conversion which fall under any of the following clauses:

１　分解能が一〇ビット以上一二ビット未満のものであって、調整された更新速度が三、五〇〇メガサンプリング毎秒を超えるもの

i.those with a resolving power of 10 bits or more and less than 12 bits and with a regulated update rate exceeding 3,500 megasamples per second;

２　分解能が一二ビット以上のものであって、次のいずれかに該当するもの

ii. circuits with a resolving power of 12 bits or more which fall under any of the following clauses:

一　調整された更新速度が一、二五〇メガサンプリング毎秒を超え三、五〇〇メガサンプリング毎秒以下のもののうち、次のいずれかに該当するもの

a. among those with a regulated update rate exceeding 1,250 megasamples per second and 3,500 megasamples or less per second, those which fall under any of the following clauses:

イ　一二ビットの分解能で動作する場合のアナログ出力値が、フルスケールのレベルからフルスケールの〇・〇二四パーセント以内のレベルに変化するまでのセトリング時間が九ナノ秒未満のもの

1 those whose settling time in which the analog output value when operated

at a resolving power of 12 bits changes from the full-scale level to a level within 0.024 % of the full-scale level is less than nine nanoseconds;

ロ　一〇〇メガヘルツのデジタル入力信号でフルスケールを出力する場合又は一〇〇メガヘルツ未満のデジタル入力信号で最も高いフルスケールを出力する場合のスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジが六八デシベルを超えるもの

2 those with a spurious free dynamic range exceeding 68 decibels when a full-scale output is made by digital input signals of 100 megahertz, or when the highest full-scale output is made by digital input signals of less than 100 megahertz;

二　調整された更新速度が三、五〇〇メガサンプリング毎秒を超えるもの

b. those with a regulated update rate exceeding 3,500 megasamples per second;

ヘ　信号処理用の電気光学的集積回路又は光集積回路であって、次の（一）から（三）までのすべてに該当するもの

(f) electro-optical integrated circuits or optical integrated circuits for signal processing, which fall under all of the following clauses 1. through 3.:

（一）　レーザー発振器を有するもの

1. those that have laser oscillators;

（二）　受光素子を有するもの

2. those that have light receiving elements;

（三）　光導波路を有するもの

3. those that have optical waveguides;

ト　フィールドプログラマブルロジックデバイス（コンプレックスプログラマブルロジックデバイス、フィールドプログラマブルゲートアレイ、フィールドプログラマブルロジックアレイ又はフィールドプログラマブル相互接続用集積回路を含む。）であって、次のいずれかに該当するもの（ワに該当するものを除く。）

(g) field programmable logic devices (including complex programmable logic devices, field programmable gate arrays, field programmable logic arrays, or field programmable integrated circuits for mutual connections), which fall under any of the following clauses (excluding those falling under sub-item (m)):

（一）　シングルエンド方式の最大デジタル入出力数が七〇〇を超えるもの

1. those with the maximum number of single-ended digital input or output exceeding 700;

（二）　シリアルトランシーバーの最大データ速度の総計が一秒当たり五〇〇ギガビット以上のもの

2. those with serial transceivers whose total maximum data speed is 500 gigabits or more per second;

チ　ニューラルネットワークを用いたもの

(h) those using neural networks;

リ　カスタム集積回路であって、次のいずれかに該当するもの

(i) custom integrated circuits that fall under any of the following clauses:

（一）　端子数が一、五〇〇を超えるもの

1. those with the number of terminals exceeding 1,500;

（二）　基本ゲート伝搬遅延時間が〇・〇二ナノ秒未満のもの

2. those with a basic gate propagation delay time of less than 0.02 nanoseconds; or

（三）　動作周波数が三ギガヘルツを超えるもの

3. those with an operating frequency exceeding 3 gigahertz;

ヌ　化合物半導体を用いたデジタル方式のものであって、次のいずれかに該当するもの（ハ、ホからリまで及びルのいずれかに該当するものを除く。）

(j) those with a digital method using compound semiconductors, which fall under any of the following clauses (excluding those which fall under any of sub-item (c), sub-items (e) through (i), or sub-item (k)):

（一）　等価ゲート数が二入力ゲート換算で三、〇〇〇を超えるもの

1. those with the number of equivalent gates exceeding 3,000 on a dual-entry gate conversion basis;

（二）　トグル周波数が一・二ギガヘルツを超えるもの

2. those with a toggle frequency exceeding 1.2 gigahertz;

ル　ＦＦＴプロセッサであって、高速フーリエ変換のミリ秒で表した定格実行時間が次に掲げる式により算出した値未満のもの（複素点の数）ｌｏｇ２（複素点の数）／２０，４８０

(k) FFT processors with a rated execution time for fast Fourier transformation expressed in milliseconds which is less than the value calculated by the following formula: (number of complex points) log 2 (number of complex points) / 20,480;

ヲ　ダイレクト・デジタル・シンセサイザ（ＤＤＳ）集積回路であって、次のいずれかに該当するもの

(l) direct digital synthesizer (DDS) integrated circuits that fall under either of the following clauses:

（一）　デジタルアナログ変換クロック周波数が三・五ギガヘルツ以上であって、デジタルアナログ変換分解能が一〇ビット以上一二ビット未満のもの

1. those with a digital-to-analogue conversion clock frequency of 3.5 gigahertz or more and a digital-to-analogue conversion resolving power of 10 bits or more and less than 12 bits; or

（二）　デジタルアナログ変換クロック周波数が一・二五ギガヘルツ以上であって、デジタルアナログ変換分解能が一二ビット以上のもの

2. those with a digital-to-analogue conversion clock frequency of 1.25 gigahertz or more and a digital-to-analogue conversion resolving power of 12 bits or more;

ワ　次の（一）及び（二）に該当するもの又はこれを実行するようにプログラムが可能なもの

(m) those that fall under the following 1. and 2., or are capable of being programmed to conduct those functions:

（一）　アナログデジタル変換機能を有するものであって、次のいずれかに該当するもの

1. those that have an analog-to-digital conversion function, which fall under any of the following devices:

１　分解能が八ビット以上一〇ビット未満のものであって、サンプルレートが一・三ギガサンプリング毎秒を超えるもの

i. those with a resolving power of 8 bits or more and less than 10 bits, and a sample rate exceeding 1.3 gigasamples per second;

２　分解能が一〇ビット以上一二ビット未満のものであって、サンプルレートが一ギガサンプリング毎秒を超えるもの

ii. those with a resolving power of 10 bits or more and less than 12 bits, and a sample rate exceeding 1 gigasamples per second;

３　分解能が一二ビット以上一四ビット未満のものであって、サンプルレートが一ギガサンプリング毎秒を超えるもの

iii. those with a resolving power of 12 bits or more and less than 14 bits, and a sample rate exceeding 1 gigasamples per second;

４　分解能が一四ビット以上一六ビット未満のものであって、サンプルレートが四〇〇メガサンプリング毎秒を超えるもの

iv. devices with a resolving power of not less than 14 bits and less than 16 bits and a sample rate exceeding 400 megasamples per second; or

５　分解能が一六ビット以上のものであって、サンプルレートが一八〇メガサンプリング毎秒を超えるもの

v. those with a resolving power of 16 bits or more and a sample rate exceeding 180 megasamples per second;

（二）　次のいずれかに該当するもの

2. those that fall under either of the following devices:

１　デジタル化されたデータを記録するもの

i. those that record digitized data;

２　デジタル化されたデータを処理するもの

ii. those that process digitized data;

二　マイクロ波用機器又はミリ波用機器の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(ii) components of apparatus for microwaves or for millimeter waves, which fall under any of the following sub-items:

イ　真空電子デバイス（クライストロン、進行波管及びこれらから派生したものを含む。以下ロにおいて同じ。）であって、次のいずれかに該当するもの（（四）に該当するものを除く。）

(a) vacuum electronic devices (including klystrons and traveling wave tubes and their derivatives; the same applies below in (b)) which fall under any

of the following clauses (excluding those falling under clause 4.):
（一）　進行波真空電子デバイスであって、次のいずれかに該当するもの
1. traveling wave vacuum electronic devices that fall under any of the following devices:
１　動作周波数が三一・八ギガヘルツを超えるもの
i. those with an operating frequency exceeding 31.8 gigahertz;
２　フィラメントを加熱してから定格出力に達するまでの時間が三秒未満の熱陰極を有するもの
ii. those that have a hot cathode for which the time from heating the filament to reaching the rated output is less than 3 seconds;
３　空胴結合形のものであって、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が七パーセントを超えるもの又は最大出力が二・五キロワットを超えるもの
iii. cavity coupled type devices for which the value obtained by dividing the instantaneous bandwidth by the center frequency exceeds 7%, or the maximum output exceeding 2.5 kilowatts;
４　ヘリックス形のもの、折返し導波管形のもの又は蛇行導波管回路形のものであって、次のいずれかに該当するもの
iv. those that are helical shaped, folded waveguide type, or have a serpentine waveguide circuit structure, which fall under any of the following clauses:
一　一オクターブを超える瞬時帯域幅を有するものであって、キロワットで表した場合の平均出力の数値にギガヘルツで表した場合の動作周波数の数値を乗じて得た数値が〇・五を超えるもの
a. those that have an instantaneous bandwidth exceeding 1 octave, for which the numerical value obtained by multiplying the numerical value for average output expressed in kilowatts by the numerical value for operating frequency expressed in gigahertz exceeds 0.5;
二　一オクターブ以下の瞬時帯域幅を有するものであって、キロワットで表した場合の平均出力の数値にギガヘルツで表した場合の動作周波数の数値を乗じて得た数値が一を超えるもの
b. those that have an instantaneous bandwidth of 1 octave or less, for which the numerical value obtained by multiplying the numerical value for average output expressed in kilowatts by the numerical value for operating frequency expressed in gigahertz exceeds 1;
三　宇宙用に設計したもの
c. those designed for space use;
四　グリッド式電子銃を有するもの
d. those that have a grid electron gun; or
５　瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセント以上のものであって、次のいずれかを有するもの
v. those for which the value obtained by dividing the instantaneous

bandwidth by the center frequency is 10% or more, which have any of the following devices:

一　環状電子ビーム

a. a cyclic electron beam;

二　非軸対称電子ビーム

b. a non-axisymmetric electron beam; or

三　複数電子ビーム

c. multiple electron beams;

（二）　クロスフィールド増幅真空電子デバイスであって、その利得が一七デシベルを超えるもの

2. crossfield amplifier vacuum electronic devices with the gain exceeding 17 decibels;

（三）　デュアルモードで操作可能なもの

3. those that are possible to be operated in a dual mode;

（四）　国際電気通信連合が無線通信用に割り当てた周波数帯域（無線測位用に割り当てた周波数帯域を除く。）で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

4. those that are designed to be used in frequency bands allotted for radio communications by the International Telecommunication Union (excluding frequency bands allotted for radio determination), which fall under any of the following clauses:

１　動作周波数が三一・八ギガヘルツ以下であるもの

i. those with an operating frequency of 31.8 gigahertz or less;

２　専ら宇宙において使用するために設計したもの以外のものであって、平均出力値が五〇ワット以下及び動作周波数が三一・八ギガヘルツ超四三・五ギガヘルツ以下のもの

ii. those other than devices exclusively designed to be used in space, whose value for average output is 50 watts or less and an operating frequency of more than 31.8 gigahertz and 43.5 gigahertz or less;

ロ　真空電子デバイスに使用するように設計した熱電子陰極であって、定格動作状態での放射電流密度が五アンペア毎平方センチメートルを超えるもの又は定格動作状態でのパルス放射電流密度が一〇アンペア毎平方センチメートルを超えるもの

(b) thermionic cathodes that are designed to be used for vacuum electronic devices, whose radiation current density exceeds 5 amperes per square centimeter in a rated operating condition, or whose pulse radiation current density exceeds 10 amperes per square centimeter in a rated operating condition;

ハ　モノリシックマイクロ波集積回路増幅器であって、次のいずれかに該当するもの（カに該当する集積化された移相器を有するモノリシックマイクロ波集積回路増幅器を除く。）

(c) monolithic microwave integrated circuit amplifiers which fall under any of the following clauses (excluding monolithic microwave integrated circuit amplifiers that have an integrated phase shifter falling under sub-item (n)):

（一）　動作周波数が二・七ギガヘルツ超六・八ギガヘルツ以下であって、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一五パーセントを超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの

1. among those with an operating frequency of more than 2.7 gigahertz and 6.8 gigahertz or less, for which the value obtained by dividing the instantaneous bandwidth by the center frequency exceeds 15%, those that fall under any of the following clauses:

１　動作周波数が二・七ギガヘルツ超二・九ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が七五ワット（四八・七五ディービーエム）超三〇〇ワット（五四・八ディービーエム）以下のもの

i. those with an operating frequency of more than 2.7 gigahertz and 2.9 gigahertz or less with a peak saturation output value of more than 75 watts (48.75 dBm) and 300 watts (54.8 dBm) or less;

２　動作周波数が二・九ギガヘルツ超三・二ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が五五ワット（四七・四ディービーエム）超三〇〇ワット（五四・八ディービーエム）以下のもの

ii. those with an operating frequency of more than 2.9 gigahertz and 3.2 gigahertz or less with a peak saturation output value of more than 55 watts (47.4 dBm) and 300 watts (54.8 dBm) or less;

３　動作周波数が三・二ギガヘルツ超三・七ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が四〇ワット（四六ディービーエム）超三〇〇ワット（五四・八ディービーエム）以下のもの

iii. those with an operating frequency of more than 3.2 gigahertz and 3.7 gigahertz or less with a peak saturation output value of more than 40 watts (46 dBm) and 300 watts (54.8 dBm) or less;

４　動作周波数が三・七ギガヘルツ超六・八ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が二〇ワット（四三ディービーエム）超三〇〇ワット（五四・八ディービーエム）以下のもの

iv. those with an operating frequency of more than 3.7 gigahertz and 6.8 gigahertz or less with a peak saturation output value of more than 20 watts (43 dBm) and 300 watts (54.8 dBm) or less;

５　動作周波数が二・七ギガヘルツ超三・七ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が三〇〇ワット（五四・八ディービーエム）を超えるもの

v. those with an operating frequency of more than 2.7 gigahertz and 3.7 gigahertz or less with a peak saturation output value of more than 300 watts (54.8 dBm); or

６　動作周波数が三・七ギガヘルツ超六・八ギガヘルツ以下であって、ピーク飽

和出力値が一二〇ワット（五〇・八ディービーエム）を超えるのもの
vi. those with an operating frequency of more than 3.7 gigahertz and 6.8 gigahertz or less with a peak saturation output value of more than 120 wats (50.8 dBm);
（二）　動作周波数が六・八ギガヘルツ超一六ギガヘルツ以下であって、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの
2. among those with an operating frequency of more than 6.8 gigahertz and 16 gigahertz or less, for which the value obtained by dividing the instantaneous bandwidth by the center frequency exceeds 10%, those which fall under any of the following clauses:
１　動作周波数が六・八ギガヘルツ超八・五ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が一〇ワット（四〇ディービーエム）超二五ワット（四四ディービーエム）以下のもの
i. those with an operating frequency of more than 6.8 gigahertz and 8.5 gigahertz or less with a peak saturation output value of more than 10 watts (40 dBm) and 25 watts (44 dBm) or less;
２　動作周波数が八・五ギガヘルツ超一二ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が五ワット（三七ディービーエム）超二五ワット（四四ディービーエム）以下のもの又は動作周波数が一二ギガヘルツ超一六ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が五ワット（三七ディービーエム）を超えるもの
ii. those with an operating frequency of more than 8.5 gigahertz and 12 gigahertz or less with a peak saturation output value of more than 5 watts (37 dBm) and 25 watts (44 dBm) or less, or those with an operating frequency of more than 12 gigahertz and 16 gigahertz or less with a peak saturation output value of more than 5 watts (37 dBm); or
３　動作周波数が六・八ギガヘルツ超一二ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が二五ワット（四四ディービーエム）を超えるもの
iii. those with an operating frequency or more than 6.8 gigahertz and 12 gigahertz or less with a peak saturation output value of more than 25 watts (44 dBm);
（三）　動作周波数が一六ギガヘルツ超三一・八ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が三ワット（三四・七七ディービーエム）を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもの
3. among those with an operating frequency over 16 gigahertz and 31.8 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 3 watts (34.77 dBm), those for which the value obtained by dividing the instantaneous bandwidth by the center frequency exceeds 10%;
（四）　動作周波数が三一・八ギガヘルツ超三七ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が〇・一ナノワット（マイナス七〇ディービーエム）を超えるもの
4. those with an operating frequency of more than 31.8 gigahertz and 37

gigahertz or less, and a peak saturation output value of more than 0.1 nanowatts (minus 70 dBm);

（五）　動作周波数が三七ギガヘルツ超四三・五ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が一・〇ワット（三〇ディービーエム）を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもの

5. among those with an operating frequency of more than 37 gigahertz and 43.5 gigahertz or less with a peak saturation output value of more than 1.0 watts (30 dBm), those for which the value obtained by dividing the instantaneous bandwidth by the center frequency exceeds 10%;

（六）　動作周波数が四三・五ギガヘルツ超七五ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が三一・六二ミリワット（一五ディービーエム）を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもの

6. among those with an operating frequency of more than 43.5 gigahertz and 75 gigahertz or less with a peak saturation output value of more than 31.62 milliwatts (15 dBm), those for which the value obtained by dividing the instantaneous bandwidth by the center frequency exceeds 10%;

（七）　動作周波数が七五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が一〇ミリワット（一〇ディービーエム）を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が五パーセントを超えるもの

7. among those with an operating frequency of more than 75 gigahertz and 90 gigahertz or less with a peak saturation output value of more than 10 milliwatts (10 dBm), those for which the value obtained by dividing the instantaneous bandwidth by the center frequency exceeds 5%;

（八）　動作周波数が九〇ギガヘルツを超え、ピーク飽和出力値が〇・一ナノワット（マイナス七〇ディービーエム）を超えるもの

8. those with an operating frequency of more than 90 gigahertz with a peak saturation output value exceeding 0.1 nanowatts (minus 70 dBm);

ニ　マイクロ波用ディスクリートトランジスタであって、次のいずれかに該当するもの

(d) microwave discrete transistors that fall under any of the following devices:

（一）　動作周波数が二・七ギガヘルツ超六・八ギガヘルツ以下であって、次のいずれかに該当するもの

1. among those with an operating frequency of more than 2.7 gigahertz and 6.8 gigahertz or less, those which fall under any of the following devices:

１　動作周波数が二・七ギガヘルツ超二・九ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が四〇〇ワット（五六ディービーエム）超六〇〇ワット（五七・八ディービーエム）以下のもの

i. those with an operating frequency of more than 2.7 gigahertz and 2.9 gigahertz or less with a peak saturation output value of more than 400 watts (56 dBm) and 600 watts (57.8 dBm) or less;

２　動作周波数が二・九ギガヘルツ超三・二ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が二〇五ワット（五三・一二ディービーエム）超六〇〇ワット（五七・八ディービーエム）以下のもの

ii. those with an operating frequency of more than 2.9 gigahertz and 3.2 gigahertz or less with a peak saturation output value of more than 205 watts (53.12 dBm) and 600 watts (57.8 dBm) or less;

３　動作周波数が三・二ギガヘルツ超三・七ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が一一五ワット（五〇・六一ディービーエム）超六〇〇ワット（五七・八ディービーエム）以下のもの

iii. those with an operating frequency of more than 3.2 gigahertz and 3.7 gigahertz or less with a peak saturation output value of more than 115 watts (50.61 dBm) and 600 watts (57.8 dBm) or less;

４　動作周波数が三・七ギガヘルツ超六・八ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が六〇ワット（四七・七八ディービーエム）超一三〇ワット（五一・二ディービーエム）以下のもの

iv. those with an operating frequency of more than 3.7 gigahertz and 6.8 gigahertz or less with a peak saturation output value of more than 60 watts (47.78 dBm) and 130 watts (51.2 dBm) or less;

５　動作周波数が二・七ギガヘルツ超三・七ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が六〇〇ワット（五七・八ディービーエム）を超えるもの

v. those with an operating frequency of more than 2.7 gigahertz and 3.7 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 600 watts (57.8 dBm); or

６　動作周波数が三・七ギガヘルツ超六・八ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が一三〇ワット（五一・二ディービーエム）を超えるもの

vi. those with an operating frequency of more than 3.7 gigahertz and 6.8 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 130 watts (51.2 dBm);

（二）　動作周波数が六・八ギガヘルツ超三一・八ギガヘルツ以下であって、次のいずれかに該当するもの

2. among those with an operating frequency of more than 6.8 gigahertz and 31. 8 gigahertz or less, those which fall under any of the following clauses:

１　動作周波数が六・八ギガヘルツ超八・五ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が五〇ワット（四七ディービーエム）超一三〇ワット（五一・二ディービーエム）以下のもの

i. those with an operating frequency over 6.8 gigahertz and 8.5 gigahertz or less and with a peak saturation output value over 50 watts (47 dBm) and 130 watts (51.2 dBm) or less;

２　動作周波数が八・五ギガヘルツ超一二ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が一五ワット（四一・七六ディービーエム）超六〇ワット（四七・八ディービーエム）以下のもの

ii. those with an operating frequency of more than 8.5 gigahertz and 12 gigahertz or less with a peak saturation output value of more than 15 watts (41.76 dBm) and 60 watts (47.8 dBm) or less;

３　動作周波数が六・八ギガヘルツ超八・五ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が一三〇ワット（五一・二ディービーエム）を超えるもの

iii. those with an operating frequency of more than 6.8 gigahertz and 8.5 gigahertz or less with a peak saturation output value of more than 130 watts (51.2 dBm);

４　動作周波数が八・五ギガヘルツ超一二ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が六〇ワット（四七・八ディービーエム）を超えるもの

iv. those with an operating frequency of more than 8.5 gigahertz and 12 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 60 watts (47.8 dBm);

５　動作周波数が一二ギガヘルツ超一六ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が四〇ワット（四六ディービーエム）を超えるもの

v. those with an operating frequency of more than 12 gigahertz and 16 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 40 watts (46 dBm); or

６　動作周波数が一六ギガヘルツ超三一・八ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が七ワット（三八・四五ディービーエム）を超えるもの

vi. those with an operating frequency of more than 16 gigahertz and 31.8 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 7 watts (38.45 dBm);

（三）　動作周波数が三一・八ギガヘルツ超三七ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が〇・五ワット（二七ディービーエム）を超えるもの

3. those with an operating frequency of more than 31.8 gigahertz and 37 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 0.5 watts (27 dBm);

（四）　動作周波数が三七ギガヘルツ超四三・五ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が一ワット（三〇ディービーエム）を超えるもの

4. those with an operating frequency of more than 37 gigahertz and 43.5 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 1 watt (30 dBm);

（五）　動作周波数が四三・五ギガヘルツを超え、ピーク飽和出力値が〇・一ナノワット（マイナス七〇ディービーエム）を超えるもの

5. those with an operating frequency of more than 43.5 gigahertz, with a peak saturation output value exceeding 0.1 nanowatts (-70 dBm);

（六）　動作周波数が八・五ギガヘルツ超三一・八ギガヘルツ以下の全ての周波数帯域において、ピーク飽和出力値が五ワット（三七ディービーエム）を超えるもの（第六条第二号ニ（一）から（五）までのいずれかに該当するものを除く。）

6. those with a peak saturation output value exceeding 5 watts (37 dBm) in all frequency bands with an operating frequency of more than 8.5 gigahertz and 31.8 gigahertz or less (excluding those falling under any of Article 6, item (ii), (d), clauses 1. through 5.);

ホ　マイクロ波用固体増幅器（モノリシックマイクロ波集積回路増幅器及びハーモニックミクサ又はコンバータを除く。）又はこれを含む組立品若しくはモジュール（送受信モジュール及び送信モジュールを除く。）であって、次のいずれかに該当するもの

(e) solid-state amplifiers for microwaves (excluding monolithic microwave integrated circuit amplifiers and harmonic mixers, or converters) or assemblies or modules including them (excluding transmission and reception modules, and transmission modules), which fall under any of the following clauses:

（一）　動作周波数が二・七ギガヘルツ超六・八ギガヘルツ以下であって、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一五パーセントを超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの

1. among those with an operating frequency of more than 2.7 gigahertz and 6.8 gigahertz or less for which the value obtained by dividing the instantaneous bandwidth by the center frequency exceeds 15%, those which fall under any of the following devices:

１　動作周波数が二・七ギガヘルツ超二・九ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が五〇〇ワット（五七ディービーエム）を超えるもの

i. those with an operating frequency of more than 2.7 gigahertz and 2.9 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 500 watts (57 dBm);

２　動作周波数が二・九ギガヘルツ超三・二ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が二七〇ワット（五四・三ディービーエム）を超えるもの

ii. those with an operating frequency of more than 2.9 gigahertz and 3.2 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 270 watts (54.3 dBm);

３　動作周波数が三・二ギガヘルツ超三・七ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が二〇〇ワット（五三ディービーエム）を超えるもの

iii. those with an operating frequency of more than 3.2 gigahertz and 3.7 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 200 watts (53 dBm); or

４　動作周波数が三・七ギガヘルツ超六・八ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が九〇ワット（四九・五四ディービーエム）を超えるもの

iv. those with an operating frequency of more than 3.7 gigahertz and 6.8 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 90 watts (49.54 dBm);

（二）　動作周波数が六・八ギガヘルツ超三一・八ギガヘルツ以下であって、瞬

時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの
2. among those with an operating frequency of more than 6.8 gigahertz and 31.8 gigahertz or less, for which the value obtained by dividing the instantaneous bandwidth by the center frequency exceeds 10%, those which fall under any of the following clauses:
１　動作周波数が六・八ギガヘルツ超八・五ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が七〇ワット（四八・四五ディービーエム）を超えるもの
i. those with an operating frequency of more than 6.8 gigahertz and 8.5 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 70 watts (48.45 dBm);
２　動作周波数が八・五ギガヘルツ超一二ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が五〇ワット（四七ディービーエム）を超えるもの
ii. those with an operating frequency of more than 8.5 gigahertz and 12 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 50 watts (47 dBm);
３　動作周波数が一二ギガヘルツ超一六ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が三〇ワット（四四・七七ディービーエム）を超えるもの
iii. those with an operating frequency of more than 12 gigahertz and 16 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 30 watts (44.77 dBm); or
４　動作周波数が一六ギガヘルツ超三一・八ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が二〇ワット（四三ディービーエム）を超えるもの
iv. those with an operating frequency of more than 16 gigahertz and 31.8 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 20 watts (43 dBm);
（三）　動作周波数が三一・八ギガヘルツ超三七ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が〇・五ワット（二七ディービーエム）を超えるもの
3. those with an operating frequency of more than 31.8 gigahertz and 37 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 0.5 watts (27 dBm);
（四）　動作周波数が三七ギガヘルツ超四三・五ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が二ワット（三三ディービーエム）を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもの
4. among those with an operating frequency of more than 37 gigahertz and 43.5 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 2 watts (33 dBm), those for which the value obtained by dividing the instantaneous bandwidth by the center frequency exceeds 10%;
（五）　動作周波数が四三・五ギガヘルツを超えるものであって、次のいずれかに該当するもの
5. among those with an operating frequency of more than 43.5 gigahertz,

those which fall under any of the following clauses:

１　動作周波数が四三・五ギガヘルツ超七五ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が〇・二ワット（二三ディービーエム）を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもの

i. among those with an operating frequency of more than 43.5 gigahertz and 75 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 0.2 watts (23 dBm), those for which the value obtained by dividing the instantaneous bandwidth by the center frequency exceeds 10%;

２　動作周波数が七五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が二〇ミリワット（一三ディービーエム）を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が五パーセントを超えるもの

ii. among those with an operating frequency of more than 75 gigahertz and 90 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 20 milliwatts (13 dBm), those for which the value obtained by dividing the instantaneous bandwidth by the center frequency exceeds 5%; or

３　動作周波数が九〇ギガヘルツ超であって、ピーク飽和出力値が〇・一ナノワット（マイナス七〇ディービーエム）を超えるもの

iii. those with an operating frequency of more than 90 gigahertz with a peak saturation output value exceeding 0.1 nanowatts (minus 70 dBm);

ヘ　電子的又は磁気的に同調可能な帯域通過フィルターであって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(f) electronically or magnetically tunable band-pass filters that fall under the following clauses 1. and 2.:

（一）　半オクターブの周波数帯域を一〇マイクロ秒未満で同調可能な可変周波数共振器を六以上有するもの

1.those that have six or more variable frequency resonators capable of tuning a frequency band of half an octave in less than 10 microseconds; and

（二）　中心周波数の〇・五パーセントを超える帯域を通過することができるもの

2. those capable of passing a band exceeding 0.5% of the center frequency;

ト　電子的又は磁気的に同調可能な帯域阻止フィルターであって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(g) electronically or magnetically tunable band-elimination filters that fall under the following clauses 1. and 2.:

（一）　半オクターブの周波数帯域を一〇マイクロ秒未満で同調可能な可変周波数共振器を六以上有するもの

1. those that have six or more variable frequency resonators capable of tuning a frequency band of half an octave in less than 10 microseconds; and

（二）　中心周波数の〇・五パーセント未満の帯域を阻止することができるもの

2. those capable of eliminating a band of less than 0.5% of the center frequency;

チ　削除

(h) Deleted

リ　ハーモニックミクサ又はコンバータであって、次のいずれかに該当するもの

(i) harmonic mixers or converters that fall under any of the following devices:

（一）　スペクトラムアナライザーの周波数帯域を九〇ギガヘルツ超に拡張するように設計したもの

1. those that are designed to expand the frequency band of a spectrum analyzer to more than 90 gigahertz;

（二）　信号発生器の動作範囲を拡張するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

2. those that are designed to extend the operating range of a signal generator, which fall under either of the following clauses:

１　周波数帯域が九〇ギガヘルツを超えるもの

i. those with a frequency band exceeding 90 gigahertz; or

２　周波数帯域が四三・五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下であって、出力が一〇〇ミリワット（二〇ディービーエム）を超えるもの

ii. those with a frequency band of more than 43.5 gigahertz and 90 gigahertz or less, whose output exceeds 100 milliwatts (20 dBm);

（三）　ネットワークアナライザーの動作範囲を拡張するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

3. those that are designed to extend the operating range of a network analyzer, which fall under any of the following devices:

１　周波数帯域が一一〇ギガヘルツを超えるもの

i. those with a frequency band of more than 110 gigahertz;

２　周波数帯域が四三・五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下であって、出力が三一・六二ミリワット（一五ディービーエム）を超えるもの

ii. those with a frequency band of more than 43.5 gigahertz and 90 gigahertz or less, whose output exceeds 31.62 milliwatts (15 dBm); or

３　周波数帯域が九〇ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下であって、出力が一ミリワット（〇ディービーエム）を超えるもの

iii. those with a frequency band of more than 90 gigahertz and 110 gigahertz or less, whose output exceeds 1 milliwatt (0 dBm);

（四）　マイクロ波用試験受信機の周波数帯域を一一〇ギガヘルツ超に拡張するように設計したもの

4. those that are designed to expand the frequency band of a microwave test receiver to more than 110 gigahertz;

ヌ　イに該当する真空電子デバイスを内蔵するマイクロ波用電力増幅器であって、次の（一）及び（二）に該当するもの（国際電気通信連合が無線通信用に割り当てた周波数帯域（無線測位用に割り当てた周波数帯域を除く。）で使用するよう

に設計したものを除く。）

(j) microwave power amplifiers with a vacuum electronic device falling under clause (a) built in, which fall under the following clauses 1. and 2. (excluding those that are designed to be used in frequency bands allotted for radio communication by the International Telecommunication Union (excluding frequency bands allotted for radio determination)):

（一）　動作周波数が三ギガヘルツを超えるもの

1. those with an operating frequency exceeding 3 gigahertz;

（二）　平均出力電力の質量に対する比が八〇ワット毎キログラムを超えるものであって、体積が四〇〇立方センチメートル未満のもの

2. those with the ratio to the mass of average output power that exceeds 80 watts per kilogram, with a volume of less than 400 cubic centimeters;

ル　マイクロ波用電力モジュールであって、進行波真空電子デバイス、モノリシックマイクロ波集積回路及び電源を有するもののうち、次の（一）から（三）までの全てに該当するもの

(k) among microwave power modules that have a traveling wave vacuum electronic device, a monolithic microwave integrated circuit, and a power supply, those which fall under all of the following clauses 1. through 3.:

（一）　完全停止状態から完全作動状態までの時間が一〇秒未満のもの

1. those for which the time between the complete shutdown state and the fully operating state is less than 10 seconds;

（二）　体積が、ワットで表した最高定格出力値に一〇立方センチメートル毎ワットを乗じて得た数値未満のもの

2. those whose volume is less than the numerical value obtained by multiplying the maximum rated output expressed in watts by 10 cubic centimeters per watt; and

（三）　一オクターブを超える瞬時帯域幅を有するものであって、次のいずれかに該当するもの

3. those having an instantaneous bandwidth exceeding 1 octave, which fall under any of the following clauses:

１　周波数が一八ギガヘルツ以下のものにあっては、無線周波数の出力が一〇〇ワットを超えるもの

i. for those with a frequency of 18 gigahertz or less, those with a radio frequency output exceeding 100 watts;

２　周波数が一八ギガヘルツを超えるもの

ii. those with a frequency exceeding 18 gigahertz;

ヲ　発振器又は発振機能を有する組立品であって、動作周波数とオフセット周波数の隔たりが一〇ヘルツ以上一〇キロヘルツ以下のいずれかの周波数帯域において、搬送波に対する一ヘルツ当たりの単側波帯位相雑音の比が次に掲げる式により算定した値未満のもの２０ｌｏｇ１０（メガヘルツで表した動作周波数）－２０ｌｏｇ１０（ヘルツで表した動作周波数とオフセット周波数の隔たり）－１２６

(l) oscillators or assemblies having an oscillation function, those for which the ratio of single sideband phase noise per hertz to carrier waves at any frequency band in which the interval between the operating frequency and the offset frequency is 10 hertz or more and less than 10 kilohertz, is less than the value calculated by the following fomula: 20 log 10 (operating frequency expressed in megahertz): 20 log 10 (interval between the operating frequency and the offset frequency expressed in hertz) -126;

ワ　周波数シンセサイザーを用いた組立品のうち、次のいずれかに該当するもの

(m) among assemblies that use frequency synthesizers, those falling under any of the following clauses:

（一）　周波数切換えの所要時間が一四三ピコ秒未満のもの

1. those for which the required time for frequency switching is 143 picoseconds;

（二）　四・八ギガヘルツ超三一・八ギガヘルツ以下の合成出力周波数範囲で、二・二ギガヘルツを超えるいずれかの周波数切換えの所要時間が一〇〇マイクロ秒未満のもの

2. those for which the required time for switching any frequency exceeding 2.2 gigahertz in the range of combined output frequency of more than 4.8 gigahertz and 31.8 gigahertz or less, is less than 100 microseconds;

（三）　削除

3. Deleted

（四）　三一・八ギガヘルツ超三七ギガヘルツ以下の合成出力周波数範囲で、五五〇メガヘルツを超えるいずれかの周波数切換えの所要時間が五〇〇マイクロ秒未満のもの

4. those for which the required time for switching any frequency exceeding 550 megahertz in the range of combined output frequency of more than 31.8 gigahertz and 37 gigahertz or less, is less than 500 microseconds;

（五）　三七ギガヘルツ超七五ギガヘルツ以下の合成出力周波数範囲で、二・二ギガヘルツを超えるいずれかの周波数切換えの所要時間が一〇〇マイクロ秒未満のもの

5. those for which the required time for switching any frequency exceeding 2.2 gigahertz in the range of combined output frequency of more than 37 gigahertz and 75 gigahertz or less, is less than 100 microseconds;

（六）　七五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下の合成出力周波数範囲で、五・〇ギガヘルツを超えるいずれかの周波数切換えの所要時間が一〇〇マイクロ秒未満のもの

6. those for which the required time for switching any frequency exceeding 5.0 gigahertz in the range of combined output frequency of more than 75 gigahertz and 90 gigahertz or less, is less than 100 microseconds; or

（七）　九〇ギガヘルツを超える合成出力周波数範囲で、周波数切換えの所要時間が一ミリ秒未満のもの

7. those for which the required time for switching the frequency in the range of combined output frequency exceeding 90 gigahertz, is less than 1 microseconds;

カ　送受信モジュール、送受信用モノリシックマイクロ波集積回路、送信モジュール及び送信用モノリシックマイクロ波集積回路であって、動作周波数が二・七ギガヘルツを超えるもののうち、次の全てに該当するもの

(n) among transmission and reception modules, monolithic microwave integrated circuits for transmission and reception, transmission modules, and monolithic microwave integrated circuits for transmission, whose operating frequency exceeds 2.7 gigahertz, those which fall under all of the following clauses:

（一）　いずれかのチャネルにおいて、ワットで表したピーク飽和出力値が五〇五・六二をギガヘルツで表した最大動作周波数の二乗で除した値を超えるもの

1. those whose peak saturation output value expressed in watts exceeds the value obtained by dividing 505.62 by the square of the maximum operating frequency expressed in gigahertz, at any channel;

（二）　いずれかのチャネルにおいて、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が五パーセント以上のもの

2. those for which the value obtained by dividing the instantaneous bandwidth by the center frequency is 5% or more, at any channel;

（三）　平面のいずれかの辺の長さをセンチメートルで表した値が、送信又は送受信チャネル数と一五の積をギガヘルツで表した最小動作周波数で除した値以下のもの

3. those for which the value of the length of any side of the plane expressed in centimeters is less than the value obtained by dividing the product of the number of channels for transmission or of channels for transmission and reception and 15 by the minimum operating frequency expressed in gigahertz; and

（四）　チャネル毎に電子的に位相シフトできるもの

4. those capable of electronically making a phase shift for each channel;

三　弾性波若しくは音響光学効果を利用する信号処理装置であって、次のいずれかに該当するもの（特定の帯域通過、低域通過、高域通過、帯域阻止又は共振の機能のいずれかのみを有するものを除く。）又はその部分品

(iii) signal processing equipment that uses elastic waves or acousto-optic effects, which fall under any of the following sub-items (excluding those that only have any of the functions of specific band-pass, low band pass, high band pass, band elimination, or resonance), or their components:

イ　表面弾性波又は疑似表面弾性波を利用するものであって、次のいずれかに該当するもの

(a) those using surface elastic waves or pseudo-surface elastic waves, which fall under any of the following clauses:

（一）　搬送周波数が六ギガヘルツを超えるもの

1. signal processing equipment with a carrier frequency exceeding 6 gigahertz;

（二）　搬送周波数が一ギガヘルツ超六ギガヘルツ以下のものであって、次のいずれかに該当するもの

2. those with a carrier frequency of more than 6 gigahertz and 2.5 gigahertz or less, which falls under any of the following equipment:

１　サイドローブに対するメインローブの電力の比が六五デシベルを超えるもの

i. those with the ratio of the main lobe power to the side lobe power that exceeds 65 decibels;

２　マイクロ秒で表した場合の最大遅延時間の数値にメガヘルツで表した場合の帯域幅の数値を乗じて得た数値が一〇〇を超えるもの

ii. those for which the numerical value of the maximum delay time expressed in microseconds multiplied by the numerical value of the bandwidth expressed in megahertz exceeds 100;

３　帯域幅が二五〇メガヘルツを超えるもの

iii. those with a bandwidth exceeding 250 megahertz; or

４　分散型遅延時間（周波数に応じた遅延時間の最大の値と最小の値との差をいう。）が一〇マイクロ秒を超えるもの

iv. those for which the distributed delay time (meaning the difference between the maximum value and minimum value for the delay time in accordance with the frequency) exceeds 10 microseconds;

（三）　搬送周波数が一ギガヘルツ以下のものであって、次のいずれかに該当するもの

3. those with a carrier frequency of 1 gigahertz or less which falls under any of the following clauses:

１　マイクロ秒で表した場合の最大遅延時間の数値にメガヘルツで表した場合の帯域幅の数値を乗じて得た数値が一〇〇を超えるもの

i. those for which the numerical value obtained by multiplying the numerical value for the maximum delay time expressed in microseconds by the numerical value of the bandwidth expressed in megahertz exceeds 100;

２　分散型遅延時間が一〇マイクロ秒を超えるもの

ii. those for which the distributed delay time exceeds 10 microseconds;

３　サイドローブに対するメインローブの電力の比が六五デシベルを超えるものであって、帯域幅が一〇〇メガヘルツを超えるもの

iii. those with the ratio of the main lobe power to the side lobe power that exceeds 65 decibels, with a bandwidth exceeding 100 megahertz;

ロ　バルク弾性波を利用するものであって、六ギガヘルツを超える周波数で信号の直接処理ができるもの

(b) those that used bulk elastic waves, which is capable of performing direct processing of signals at frequencies exceeding 6 gigahertz;

ハ　弾性波と光波の相互作用を利用したものであって、信号又は画像の直接処理ができるもの

(c) those that use the interaction of elastic waves and light waves, which is capable of performing direct signal or image processing;

四　超電導材料を用いた装置のうち、超電導材料を用いた部品を有する電子素子又は電子回路であって、使用する超電導材料の臨界温度より低い温度で使用することができるように設計し、かつ、次のいずれかに該当するもの

(iv) among devices using superconductive materials, those that are electron devices or electronic circuits with components using superconductive materials, which are designed to be usable at temperatures lower than the critical temperature of the superconductive materials used, and, fall under either of the following sub-items:

イ　超電導ゲートを有するデジタル回路用の電流スイッチングの機能を有するものであって、ゲート当たりの遅延時間にゲート当たりの電力消費を乗じて得た値が一、〇〇〇億分の一ミリジュール未満のもの

(a) those that possess a current switching function for digital circuits with superconducting gates, for which the value obtained by multiplying the delay time per gate by the power consumption per gate is less than 1/100 billion millijoules; or

ロ　周波数分離の機能を有するものであって、キュー値が一〇、〇〇〇を超える共振回路を有するもの

(b) those that have a frequency separation function and resonant circuits with a cue value exceeding 10,000;

五　セル（バッテリー（シングルセルバッテリーを含む。）に組み込まれているものを除く。）であって、次のいずれかに該当するもの

(v) cells (excluding those incorporated in batteries (including single cell batteries)) that fall under any of the following sub-items:

イ　一次セルであって、二〇度の温度におけるエネルギー密度及び電力密度が次のいずれかに該当するもの

(a) primary cells whose energy density and power density at a temperature of 20 degrees centigrade fall under either of the following clauses:

（一）　エネルギー密度が五五〇ワット時毎キログラムを超え、かつ、連続的な電力密度が五〇ワット毎キログラムを超えるもの

1. those with an energy density exceeding 550 watt-hours per kilogram, and, a continuous power density exceeding 50 watts per kilogram; or

（二）　エネルギー密度が五〇ワット時毎キログラムを超え、かつ、連続的な電力密度が三五〇ワット毎キログラムを超えるもの

2. those with an energy density exceeding 50 watt-hours per kilogram, and, a continuous power density exceeding 350 watts per kilogram;

ロ　二次セルであって、二〇度の温度におけるエネルギー密度が三五〇ワット時毎キログラムを超えるもの

(b) secondary cells with an energy density exceeding 350 watt-hours per kilogram at a temperature of 20 degrees centigrade;

六　高電圧用のコンデンサであって、次のいずれかに該当するもの

(vi) high voltage capacitors that fall under any of the following sub-items:

イ　反復サイクルが一〇ヘルツ未満のコンデンサであって、次の（一）から（三）までのすべてに該当するもの

(a) capacitors with a repeat cycle of less than 10 hertz, which fall under all of the following clauses 1. through 3.:

（一）　定格電圧が五キロボルト以上のもの

1. those with a rated voltage of 5 kilovolts or more;

（二）　エネルギー密度が二五〇ジュール毎キログラム以上のもの

2. those with an energy density of 250 joules per kilogram or more; and

（三）　総エネルギーが二五キロジュール以上のもの

3. those with a total energy of 25 kilojoules or more;

ロ　反復サイクルが一〇ヘルツ以上のコンデンサであって、次の（一）から（四）までのすべてに該当するもの

(b) capacitors with a repeat cycle of 10 hertz or more, which fall under all of the following clauses 1. through 4.:

（一）　定格電圧が五キロボルト以上のもの

1. those with a rated voltage of 5 kilovolts or more;

（二）　エネルギー密度が五〇ジュール毎キログラム以上のもの

2. those with an energy density of 50 joules per kilogram or more;

（三）　総エネルギーが一〇〇ジュール以上のもの

3. those with a total energy of 100 joules or more; and

（四）　一〇、〇〇〇回以上充電及び放電の繰り返しをすることができるように設計したもの

4. those that are designed so that they can be charged and discharged repeatedly for more than 10,000 times;

七　一秒を要しないで磁界を完全に形成させ、又は消失させるように設計した超電導電磁石（ソレノイドコイル形のものを含む。）であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの

(vii) superconducting electromagnets (including solenoid coil types) that are designed to fully generate or dissipate a magnetic field in less than one second, which fall under all of the following sub-items (a) through (c):

イ　減磁の際に最初の一秒間で放出するエネルギーが一〇キロジュールを超えるもの

(a) those that discharge energy exceeding 10 kilojoules in the first second of demagnetization;

ロ　コイルの内径が二五〇ミリメートルを超えるもの

(b) those whose coil has an internal diameter exceeding 250 millimeters; and

ハ　定格最大電流密度が三〇〇アンペア毎平方ミリメートルを超えるもの又は定格

磁束密度が八テスラを超えるもの

(c) those with a rated maximum current density exceeding 300 amperes per square millimeter, or with a rated magnetic flux density exceeding 8 teslas;

七の二　太陽電池セル、セル連結保護ガラス集成品、太陽電池パネル又は太陽光アレーであって、宇宙用に設計したもののうち、エア・マス・ゼロで一、三六七ワット毎平方メートルの照射を受けたときの最小平均変換効率が、二八度の動作温度において二〇パーセントを超えるもの

(vii)-2 among solar batteries, cell-interconnect-coverglass assemblies, solar panels, or solar arrays, which are designed for space use, those for which the minimum average conversion efficiency when irradiated by 1,367 watts per square meter at air mass zero exceeds 20 % at an operating temperature of 28 degrees centigrade;

八　回転入力型のアブソリュートエンコーダであって、角度の変換誤差の絶対値が一秒以下のもの及び当該エンコーダ用に設計されたリング、ディスク又はスケール

(viii) rotary input-type absolute encoders for which the absolute value of the conversion error of angles is 1 second or less, and rings, disks, or scales that are designed for those encoders;

八の二　パルス出力の切換えを行うサイリスターデバイス又はサイリスターモジュールであって、電気的に若しくは光学的に制御された切換え方法又は電子の放射を制御された切換え方法を用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの（民生用の鉄道車両又は航空機に使用するように設計された装置に組み込まれたものを除く。）

(viii)-2 among thyristor devices or thyristor modules that perform switching of pulse output, using an electronically or optically controlled switching method, or a switching method with a controlled electron emission, those that fall under either of the following sub-items (excluding those incorporated into a device designed to be used for railroad vehicles or aircraft for civilian use):

イ　最大立上がり電流が三〇、〇〇〇アンペア毎マイクロ秒を超えるものであって、休止状態電圧が一、一〇〇ボルトを超えるもの

(a) those with a maximum starting current exceeding 30,000 amperes per microsecond, and an off-state voltage exceeding 1,100 volts; or

ロ　最大立上がり電流が二、〇〇〇アンペア毎マイクロ秒を超えるものであって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(b) those with a maximum starting current exceeding 2,000 amperes per microsecond, which fall under the following clauses 1. and 2.:

（一）　休止状態電圧が三、〇〇〇ボルト以上のもの

1. those with an off-state voltage of 3,000 volts or more; and

（二）　最大電流が三、〇〇〇アンペア以上のもの

2. those with a maximum current of 3,000 amperes or more;

八の三　電力の制御又は電気信号の整流を行う半導体素子又は半導体モジュールであって、次のイからハまでのすべてに該当するもの（民生用の自動車、鉄道車両又は

航空機に使用するように設計された装置に組み込まれたものを除く。）

(viii)-3 semiconductor devices or semiconductor modules that control electric power or rectify electric signals, which fall under all of the following sub-items (a) through (c) (excluding those incorporated into a device that are designed to be used for automobiles, railroad vehicles, or aircraft, for civilian use):

イ　最大動作接合部温度が二一五度を超えるように設計したもの

(a) those that are designed to have a maximum operating junction temperature that exceeds 215 degrees centigrade;

ロ　繰返しピーク休止状態電圧が三〇〇ボルトを超えるもの

(b) those with a repetitive peak off state voltage exceeding 300 volts; and

ハ　継続電流が一アンペアを超えるもの

(c) those with a continuous current exceeding one ampere;

八の四　アナログ信号用に設計した光の強度、振幅又は位相を操作する電気光学効果を利用する光変調器であって、次のいずれかに該当するもの（光入出力コネクタを有するものを含む。）

(viii)-4 optical modulators using electrooptic effects which operate the intensity, amplitude, or phases of light designed for analog signals, which fall under any of the following modulators (including those which have an optical input and output connector):

イ　最大動作周波数が一〇ギガヘルツ超二〇ギガヘルツ未満であって、光挿入損失が三デシベル以下のもののうち、次のいずれかに該当するもの

(a) among those with a maximum operating frequency of more than10 gigahertz and less than 20 gigahertz and with an optical insertion loss of 3 decibels or less, those which fall under any of the following clauses:

（一）　一ギガヘルツ以下の周波数で測定した場合の半波長電圧が二・七ボルト未満のもの

1. those with a half-wave voltage of less than 2.7 volts measured at a frequency of 1 gigahertz or less; or

（二）　一ギガヘルツを超える周波数で測定した場合の半波長電圧が四ボルト未満のもの

2. those with a half-wave voltage of less than 4 volts measured at a frequency exceeding 1 gigahertz;

ロ　最大動作周波数が二〇ギガヘルツ以上のものであって、光挿入損失が三デシベル以下のもののうち、次のいずれかに該当するもの

(b) among modulators with the maximum operating frequency of 20 gigahertz or more and with an optical insertion loss of 3 decibels or less, those which fall under any of the following clauses:

（一）　一ギガヘルツ以下の周波数で測定した場合の半波長電圧が三・三ボルト未満のもの

1. those with a half-wave voltage of less than 3.3 volts measured at a

frequency of 1 gigahertz or less; or

（二）　一ギガヘルツを超える周波数で測定した場合の半波長電圧が五ボルト未満のもの

2. those with a half-wave voltage of less than 5 volts measured at a frequency exceeding 1 gigahertz;

九　サンプリングオシロスコープであって、リアルタイムサンプリング手法を用いているもののうち、いずれかのチャネルの入力三デシベル帯域幅が六〇ギガヘルツ以上の場合において、そのチャネルのノイズが最小となる縦軸レンジにおけるノイズ電圧の二乗平均平方根がフルスケールの二パーセント未満のもの

(ix) among sampling oscilloscopes that use the method of real-time sampling, those for which the root-mean-square of noise voltage at the vertical axis range in which the noise of the channel is the smallest is less than 2% of the full scale, when the input 3-decibel bandwidth of any channel is 60 gigahertz or more;

十　アナログデジタル変換器のうち、アナログデジタル変換を行う機能を有するモジュール、組立品又は装置（アナログデジタル変換カード、波形デジタイザー、データ収集カード、信号収集ボード及びトランジェントレコーダーを含む。）であって、次のイ及びロに該当するもの（デジタル方式の記録装置、サンプリングオシロスコープ、スペクトラムアナライザー、信号発生器、ネットワークアナライザー及びマイクロ波用試験受信機を除く。）

(x) among analog-digital converters, modules, assemblies, or devices having the function of performing analog-to-digital conversions (including analog-to-digital conversion cards, waveform digitizers, data acquisition cards, signal acquisition boards, and transient recorders), which fall under the following sub-items (a) and (b) (excluding digital recording devices, sampling oscilloscopes, spectrum analyzers, signal generators, network analyzers, and microwave test receivers):

イ　分解能及びサンプルレートが次のいずれかに該当するもの

(a) those whose resolving power and sample rate fall under any of the following clauses:

（一）　分解能が八ビット以上一〇ビット未満のものであって、サンプルレートが一・三ギガサンプル毎秒を超えるもの

1. those with a resolving power of more than 8 bits and less than 10 bits, whose sample rate exceeds 1.3 gigasamples per second;

（二）　分解能が一〇ビット以上一二ビット未満のものであって、サンプルレートが一ギガサンプル毎秒を超えるもの

2. those with a resolving power of more than 10 bits and less than 12 bits, whose sample rate exceeds 1 gigasample per second;

（三）　分解能が一二ビット以上一四ビット未満のものであって、サンプルレートが一ギガサンプル毎秒を超えるもの

3. those with a resolving power of more than 12 bits and less than 14 bits,

whose sample rate exceeds 1 gigasample per second;

（四）　分解能が一四ビット以上一六ビット未満のものであって、サンプルレートが四〇〇メガサンプル毎秒を超えるもの

4. those with a resolving power of more than 14 bits and less than 16 bits, whose sample rate exceeds 400 megasamples per second; or

（五）　分解能が一六ビット以上のものであって、サンプルレートが一八〇メガサンプル毎秒を超えるもの

5. those with a resolving power of more than 16 bits whose sample rate exceeds 180 megasamples per second;

ロ　次のいずれかの機能を持つもの

(b) those that have any of the following functions:

（一）　デジタル化されたデータを出力するもの

1. those that output digitized data;

（二）　デジタル化されたデータを記録するもの

2. those that record digitized data; or

（三）　デジタル化されたデータを処理するもの

3. those that process digitized data;

十一　デジタル方式の記録装置であって、次のイ及びロに該当するもの

(xi) digital recording devices that fall under the following sub-items (a) and (b):

イ　ディスクメモリ又はソリッドステートドライブメモリへのデータ連続記録速度が六・四ギガビット毎秒を超えて維持可能なもの

(a) those capable of maintaining a speed of continuous data recording to a disk memory or a solid-state drive memory of over 6.4 gigabits per second; and

ロ　記録中の無線周波数信号データを信号処理することができるもの

(b) those capable of performing signal processing of radio frequency signal data being recorded;

十二　スペクトラムアナライザーであって、次のいずれかに該当するもの

(xii) spectrum analyzers that fall under any of the following sub-items:

イ　三一・八ギガヘルツ超三七ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域で、三デシベルの分解能帯域幅が四〇メガヘルツを超えるもの

(a) those for which the resolution bandwidth of 3 decibels at any frequency band of more than 31.8 gigahertz and 37 gigahertz or less exceeds 40 megahertz;

ロ　四三・五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域で、表示平均ノイズレベルがマイナス一五〇ディービーエム毎ヘルツ未満のもの

(b) those whose displayed average noise level at any frequency band of more than 43.5 gigahertz and 90 gigahertz or less, is less than minus 150 dBm per hertz;

ハ　九〇ギガヘルツを超える周波数を分析することができるもの

(c) those capable of analyzing frequency that exceeds 90 gigahertz; or

ニ　次の（一）及び（二）に該当するもの

(d) those that fall under the following clauses 1. and 2.:

（一）　実時間帯域幅が一七〇メガヘルツを超えるもの

1. those with a real-time bandwidth that exceeds 170 megahertz; and

（二）　次のいずれかに該当するもの

2. those that fall under either of the following clauses:

１　一五マイクロ秒以下の長さの信号を、ギャップ又は窓効果による全振幅からの減衰が三デシベル未満で、一〇〇パーセントの確率で検出するもの

i. those that detect signals with a length of 15 microseconds or less for which the damping from the total amplitude by a gap or window effect is less than 3 decibels with a 100% probability; or

２　周波数マスクトリガー機能を有するものであって、一五マイクロ秒以下の長さの信号を一〇〇パーセントの確率で捉えるもの

ii. those with a frequency mask trigger function that detect signals with a length of 15 microseconds or less with a 100% probability;

十三　信号発生器であって、次のいずれかに該当するもの（二以上の水晶発振器の周波数を加算した値、減算した値又はこれらの値を逓倍した値によって出力周波数を規定する装置を除く。）

(xiii) signal generators that fall under any of the following sub-items (excluding devices that specify output frequencies by values obtained by adding or subtracting the frequencies of two or more crystal oscillators, or values obtained by multiplying those values):

イ　三一・八ギガヘルツ超三七ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域で、次の（一）及び（二）に該当するパルス変調信号を発振するもの

(a) those that generate pulse modulated signals falling under the following clauses 1. and 2. at any frequency band of more than 31.8 gigahertz and 37 gigahertz or less:

（一）　パルス幅が二五ナノ秒未満のもの

1. those with a pulse width of less than 25 nanoseconds; and

（二）　オン・オフ比が六五デシベル以上のもの

2. those with an on/off ratio of 65 decibels or more;

ロ　四三・五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域で、出力一〇〇ミリワット（二〇ディービーエム）を超えるもの

(b) those with an output exceeding 100 milliwatts (20 dBm) at any frequency band of more than 43.5 gigahertz and 90 gigahertz or less;

ハ　次のいずれかに該当するもの

(c) those that fall under any of the following clauses:

（一）　削除

1. Deleted

（二）　四・八ギガヘルツ超三一・八ギガヘルツ以下の出力周波数帯域で、二・二ギガヘルツを超えるいずれかの周波数切換えの所要時間が一〇〇マイクロ秒未

満のもの

2. those with the time required to switch any frequency exceeding 2.2 gigahertz at the output frequency band of more than 4.8 gigahertz and 31.8 gigahertz or less, is less than 100 microseconds;

（三）　削除

3. Deleted

（四）　三一・八ギガヘルツ超三七ギガヘルツ以下の出力周波数帯域で、五五〇メガヘルツを超えるいずれかの周波数切換えの所要時間が五〇〇マイクロ秒未満のもの

4. those with the required time to switch any frequency exceeding 550 megahertz at the output frequency band of more than 31.8 gigahertz and 37 gigahertz or less, is less than 500 microseconds;

（五）　三七ギガヘルツ超七五ギガヘルツ以下の出力周波数帯域で、二・二ギガヘルツを超えるいずれかの周波数切換えの所要時間が一〇〇マイクロ秒未満のもの

5. those with the required time to switch any frequency exceeding 2.2 gigahertz at the output frequency band of more than 37 gigahertz and 75 gigahertz or less, is less than 100 microseconds; or

（六）　七五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下の出力周波数帯域で、五・〇ギガヘルツを超えるいずれかの周波数切換えの所要時間が一〇〇マイクロ秒未満のもの

6. those with the required time to switch any frequency exceeding 5.0 gigahertz at the output frequency band of more than 75 gigahertz and 90 gigahertz or less, is less than 100 microseconds;

ニ　搬送波に対する一ヘルツ当たりの単側波帯位相雑音の比が次のいずれかに該当するもの

(d) those for which the ratio of the single side band phase noise per hertz to the carrier signal falls under any of the following values:

（一）　三・二ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下のいずれかの出力周波数帯域で、動作周波数とオフセット周波数の隔たりが一〇ヘルツ以上一〇キロヘルツ以下のいずれかの周波数帯域において、次に掲げる式により算定した値未満のもの２０ｌｏｇ１０（メガヘルツで表した動作周波数）－２０ｌｏｇ１０（ヘルツで表した動作周波数とオフセット周波数の隔たり）－１２６

1. those for which at any output frequency band of more than 3.2 gigahertz and 90 gigahertz or less in which the interval between the operating frequency and the offset frequency at any of the frequency band of 10 hertz or more and 10 kilohertz or less, is less than the value obtained by the following formula: 20 log 10 (operating frequency expressed in megahertz)- 20 log 10 (the interval between the operating frequency and the offset frequency expressed in hertz) - 126; or

（二）　三・二ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下のいずれかの出力周波数帯域で、

動作周波数とオフセット周波数の隔たりが一〇キロヘルツ超一〇〇キロヘルツ以下のいずれかの周波数帯域において、次に掲げる式により算定した値未満のもの
２０１ｏｇ１０（メガヘルツで表した動作周波数）－２０６
2. those for which at any output frequency band of more than 3.2 gigahertz and 90 gigahertz or less in which the interval between the operating frequency and the offset frequency at any of the frequency band of more than 10 kilohertz and 100 kilohertz or less: 20 log 10 (operating frequency expressed in megahertz) -206;

ホ　デジタルベースバンド信号をベクトル変調する機能を有するもので、ベクトル変調帯域幅が次のいずれかに該当するもの
(e) those that have a function of performing vector modulation of digital baseband signals for which the vector modulation bandwidth falls under any of the following clauses:

（一）　四・八ギガヘルツ超三一・八ギガヘルツ以下の出力周波数帯域で、二・二ギガヘルツを超えるもの
1. vector modulation bandwidth exceeding 2.2 gigahertz at the output frequency band of more than 4.8 gigahertz and 31.8 gigahertz or less;

（二）　三一・八ギガヘルツ超三七ギガヘルツ以下の出力周波数帯域で、五五〇メガヘルツを超えるもの
2. vector modulation bandwidth exceeding 550 megahertz at the output frequency band of more than 31.8 gigahertz and 37 gigahertz or less;

（三）　三七ギガヘルツ超七五ギガヘルツ以下の出力周波数帯域で、二・二ギガヘルツを超えるもの
3. vector modulation bandwidth exceeding 2.2 gigahertz at the output frequency band of more than 37 gigahertz and 75 gigahertz or less;

（四）　七五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下の出力周波数帯域で、五・〇ギガヘルツを超えるもの
4. vector modulation bandwidth exceeding 5.0 gigahertz at the output frequency band of more than 75 gigahertz and 90 gigahertz or less;

ヘ　最大出力周波数が九〇ギガヘルツを超えるもの
(f) those with a maximum output frequency exceeding 90 gigahertz;

十四　ネットワークアナライザーであって、次のいずれかに該当するもの
(xiv) network analyzers that fall under any of the following sub-items:

イ　四三・五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下のいずれかの動作周波数帯域において、出力が三一・六二ミリワット（一五ディービーエム）を超えるもの
(a) those with an output exceeding 31.62 milliwatts (15 dBm) at any operating frequency band of more than 43.5 gigahertz and 90 gigahertz or less;

ロ　九〇ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下のいずれかの動作周波数帯域において、出力が一ミリワット（〇ディービーエム）を超えるもの
(b) those with an output exceeding 1 milliwatt (0 dBm) at any operating

frequency band of more than 90 gigahertz and 110 gigahertz or less;

ハ　五〇ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下の周波数帯域における非線形ベクトルの計測機能を有するもの（イ又はロに該当するものを除く。）

(c) those with a measuring function of non-linear vectors at the frequency band of more than 50 gigahertz and 110 gigahertz or less (excluding those that fall under sub-item (a) or (b)); or

ニ　最大動作周波数が一一〇ギガヘルツを超えるもの

(d) those with a maximum operating frequency exceeding 110 gigahertz;

十五　マイクロ波用試験受信機であって、次のイ及びロに該当するもの

(xv) microwave test receivers that fall under the following sub-items (a) and (b):

イ　一一〇ギガヘルツを超える周波数で使用することができるように設計したもの

(a) those designed to be used at frequencies exceeding 110 gigahertz; and

ロ　振幅及び位相を同時に測定できるもの

(b) those that can simultaneously measure amplitude and phase;

十六　原子周波数標準器であって、次のいずれかに該当するもの

(xvi) atomic frequency standards that fall under any of the following sub-items:

イ　ルビジウムを用いていないものであって、三〇日間連続して発振したときの安定度が一、〇〇〇億分の一未満のもの

(a) those that do not use rubidium, for which the stability when oscillated continuously for 30 days is less than 1/ 100 billion;

ロ　宇宙用に設計したもの

(b) those that are designed for space use;

ハ　宇宙用に設計していないものであって、次の（一）から（三）までのすべてに該当するもの

(c) those that are not designed for space use, which fall under all of the following clauses 1. through 3.:

（一）　ルビジウムを用いたもの

1. those that use rubidium;

（二）　三〇日間連続して発振したときの安定度が一、〇〇〇億分の一未満のもの

2. those with a stability of less than 1/100 billion when oscillated continuously for 30 days;

（三）　消費電力が一ワット未満のもの

3. those with a power consumption of less than 1 watt;

十六の二　スプレー冷却方式の熱制御装置であって、密閉された装置の中で冷媒の循環利用ができるもののうち、電気部品に絶縁冷媒を吹き付けて部品の温度を一定の範囲に収めるために特に設計した噴霧ノズルを有するもの又はそのために特に設計した部分品

(xvi)-2 among temperature control devices by a spray cooling method which are capable of cyclically using the cooling medium inside a closed device, those

having an atomizing nozzle specially designed to spray isolating cooling medium on electric components and keep those components' temperature within a fixed range, or components specially designed for that purpose;

十七　半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置（ホにおいて「半導体製造装置」という。）若しくは試験装置若しくは集積回路の製造用のマスク若しくはレチクルであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品若しくは附属品

(xvii) devices for manufacturing semiconductor element, integrated circuits, or semiconductor materials (referred to as "semiconductor manufacturing equipment" in (e)) or testing devices or masks or reticles for manufacturing integrated circuits, which fall under any of the following sub-items, or their components and accessories:

イ　結晶のエピタキシャル成長装置であって、次のいずれかに該当するもの

(a) epitaxial growth systems for crystals which fall under any of the following clauses:

（一）　七五ミリメートル以上の長さにわたり膜の厚さの許容差の絶対値が二・五パーセント未満のシリコン以外の膜を形成するように設計又は改造したもの

1. those that are designed or modified to form films other than silicon whose absolute value of the tolerance of film thickness is less than 2.5 percent for a length of 75 millimeters or more;

（二）　有機金属化学的気相成長反応炉であって、アルミニウム、ガリウム、インジウム、砒素、燐、アンチモン又は窒素のいずれか二以上の元素を有する化合物半導体をエピタキシャル成長させるもの

2. metal-organic chemical vapor deposition reactors that epitaxially grow compound semiconductors which have two or more of any of the elements of aluminum, gallium, indium, arsenic, phosphor, antimony, or nitrogen;

（三）　ガス源又は固体源を用いた分子線エピタキシャル成長装置

3. molecular beam epitaxial growth systems using gas sources or solid sources;

ロ　イオン注入装置であって、次のいずれかに該当するもの

(b) ion implantation equipment that fall under any of the following clauses:

（一）　削除

1. Deleted

（二）　水素、重水素又はヘリウムを注入する場合において、ビームエネルギーが二〇キロ電子ボルト以上、かつ、ビーム電流が一〇ミリアンペア以上で作動するように設計し、最適化したもの

2. those that are designed and optimized to operate when implanting hydrogen, heavy hydrogen, or helium, at a beam energy of 20 kiloelectron volts or more, and, a beam current of 10 milliamperes or more;

（三）　直接描画を行うことができるもの

3. those that are capable of direct writing;

（四）　加熱された半導体材料の基板へ酸素を注入する場合において、ビームエネルギーが六五キロ電子ボルト以上、かつ、ビーム電流が四五ミリアンペア以上のもの

4. those whose beam energy is 65 kiloelectron volts or more, and, beam current of 45 milliamperes or more when injecting oxygen to the substrate of a heated semiconductor material; or

（五）　六〇〇度以上の温度に加熱された半導体材料の基板へシリコンを注入する場合において、ビームエネルギーが二〇キロ電子ボルト以上、かつ、ビーム電流が一〇ミリアンペア以上で作動するように設計し、最適化したもの

5. those that are designed and optimized to operate, at a beam energy of 20 kiloelectron volts or more, and, a beam current of 10 milliamperes or more when injecting silicon to a semiconductor material substrate heated to a temperature of 600 degrees centigrade or more;

ハ　削除

(c) Deleted

ニ　削除

(d) Deleted

ホ　自動的にウエハーの装填を行うことができるマルチチャンバー対応ウエハー搬送中央装置であって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(e) multi-chamber central wafer transfer systems capable of automatically loading wafers, which fall under the following clauses 1. and 2.:

（一）　イ（一）から（三）まで又はロ（二）から（五）までのいずれかに該当する半導体製造装置であってそれぞれ異なるものを三台以上接続することができるように設計したウエハーの出し入れ用の接続部を有するもの（異なる機能を有するものを接続することができるものに限る。）

1. semiconductor manufacturing equipment that falls under any of (a), clauses 1. through 3., or (b), clauses 2. through 5. with a connecting part for input and output of wafers which is designed to be capable of connecting three or more different units of equipment (limited to those capable of connecting those with different functions);

（二）　複数のウエハーの処理を順次行うために真空状態で一体化された装置を構成するように設計したもの

2. those that are designed to form an integrated system in a vacuum for conducting consecutive processing of multiple wafers;

ヘ　リソグラフィ装置であって、次のいずれかに該当するもの

(f) lithography equipment that falls under any of the following clauses:

（一）　ウエハーの処理のためのステップアンドリピート方式又はステップアンドスキャン方式の露光装置であって、光学方式のもの又はエックス線を用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの

1. among step and repeat method or step and scan method align and expose equipment for wafer processing using photo-optical or x-ray methods, those

that fall under any of the following clauses:
１　光源の波長が一九三ナノメートル未満のもの
i. those with a light source wavelength of less than 193 nanometers; or
２　ナノメートルで表した光源の波長に〇・三五を乗じて得た数値を開口数の値で除して得た数値が四五以下のもの
ii. those for which the numerical value obtained by multiplying the exposure light source wavelength expressed in nanometers by 0.35, then dividing that numerical value by the numerical aperture is 45 or less;
（二）　インプリントリソグラフィ装置であって、四五ナノメートル以下の線幅を実現することができるもの
2. imprint lithography equipment capable of producing a line width of 45 nanometers or less;
（三）　マスクの製造をすることができるように設計した装置であって、電子ビーム、イオンビーム又はレーザー光を用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの
3. among devices that are designed to be capable of manufacturing masks which use electron beams, ion beams, or laser beams, those that fall under any of the following clauses:
１　照射面の半値全幅の直径が六五ナノメートル未満、かつ、イメージ位置誤差（平均値に三シグマを加えたもの）が一七ナノメートル未満のもの
i. those for which the diameter of the full-width half-maximum of its irradiation face is less than 65 nanometers, and, whose image position error (3 sigmas added to the mean value) is less than 17 nanometers;
２　削除
ii. Deleted
３　マスク上の二層目の重ね合わせ誤差（平均値に三シグマを加えたもの）が二三ナノメートル未満のもの
iii. those for which the superposition error (3 sigmas added to the mean value) is less than 23 nanometers in the second layer on the mask;
（四）　直接描画方式で半導体素子又は集積回路の製造をすることができるように設計した装置であって、電子ビームを用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの
4. among devices that are designed to be capable of manufacturing semiconductor elements or integrated circuits by a line drawing method which use an electron beam, those that fall under any of the following clauses:
１　照射面の直径が一五ナノメートル以下のもの
i. those whose irradiation face is 15 nanometers or less in diameter; or
２　重ね合わせ誤差（平均値に三シグマを加えたもの）が二七ナノメートル以下のもの
ii. those with a superposition error (3 sigmas added to the mean value) of

27 nanometers or less;

ト　マスク又はレチクルであって、第一号から第八号の四までのいずれかに該当する集積回路の製造用のもの

(g) masks or reticles for manufacturing integrated circuits that fall under any of items (i) through (viii)-4;

チ　位相シフト膜を有する多層マスクであって、光源の波長が二四五ナノメートル未満のリソグラフィ装置に用いるために設計したもの（トに該当するもの及び第一号から第八号の四までのいずれにも該当しない記憶素子を製造するために設計したものを除く。）

(h) multilayer masks with a phase shift mask which are designed to be used in lithography equipment with a light source wavelength that is shorter than 245 nanometers (excluding those which fall under sub-item (g), and those designed for manufacturing memory elements that do not fall under any of items (i) through (viii)-4):

リ　インプリントリソグラフィテンプレートであって、第一号から第八号の四までのいずれかに該当する集積回路の製造用のもの

(i) imprint lithography templates for manufacturing integrated circuits that fall under any of items (i) through (viii)-4;

ヌ　試験装置であって、半導体素子若しくは集積回路又はこれらの半製品用のもののうち、次のいずれかに該当するもの

(j) among testing device that are semiconductor devices or integrated circuits, or their semi-finished products, those that fall under any of the following clauses:

（一）　第二号ニに該当する貨物のエスパラメータを試験することができるように設計したもの

1. those designed to be capable of testing the S-parameters of goods falling under item (ii), sub-item (d);

（二）　削除

2. Deleted

（三）　第二号ハに該当する貨物の試験を行うことができるように設計したもの

3. those designed to be capable of testing goods falling under item (ii), sub-item (c);

十七の二　マスクの製造に用いられる基材であって、モリブデン及びシリコンからなる多層膜の反射構造を有するマスクブランクのうち、次のイ及びロに該当するもの

(xvii)-2 among base materials to be used for manufacturing masks which are mask blanks that have a reflection structure of a multilayer film composed of molybdenum and silicon, those which fall under the following sub-items (a) and (b):

イ　極端紫外を用いて集積回路を製造するための装置用に特に設計したもの

(a) those specially designed for devices for manufacturing integrated circuits using extreme-ultraviolet; and

ロ　国際半導体製造装置材料協会が定めたＳＥＭＩ規格Ｐ三七の仕様に準拠したもの

(b) those which conform to the specifications of the SEMI Standards P37 specified by the Semiconductor Equipment and Materials International;

十八　基板であって、当該基板の上に次のいずれかに該当する物質の多層膜の結晶を有し、かつ、当該結晶がエピタキシャル成長されているもののうち、ヘテロエピタキシャル材料となるもの（ニに該当する化合物（窒化ガリウム、窒化インジウムガリウム、窒化アルミニウムガリウム、窒化インジウムアルミニウム、窒化インジウムアルミニウムガリウム、リン化ガリウム、砒化ガリウム、砒化アルミニウムガリウム、リン化インジウム、リン化インジウムガリウム、リン化アルミニウムインジウム又はリン化インジウムガリウムアルミニウムに限る。）のＰ型エピタキシャル層を一層以上有するものであって、当該Ｐ型エピタキシャル層がＮ型層に挟まれていないものを除く。）

(xviii) among substrates which have multilayer film crystals of the substance falling under any of the following substances on the substrates, and, for which those crystals have been formed through epitaxial growth, those which are to be hetero epitaxial materials (excluding those that have one or more layers of P-type epitaxial layers of compounds that fall under clasue (d) (limited to gallium nitride, indium gallium nitride, aluminum gallium nitride, indium aluminum nitride, indium aluminum gallium nitride, gallium phosphide, gallium arsenide, aluminum gallium arsenide, indium phosphide, indium gallium phosphide, aluminum indium phosphide, or indium gallium aluminum phosphide) for which the P-type epitaxial layers are not wedged between N-type layers):

イ　シリコン

(a) silicon;

ロ　ゲルマニウム

(b) germanium;

ハ　炭化けい素

(c) silicon carbide;

ニ　ＩＩＩ―Ｖ族化合物（ガリウム又はインジウムの化合物に限る。）

(d) III-V compounds (limited to gallium or indium compounds);

ホ　三酸化二ガリウム

(e) gallium oxide (Ga2O3);

ヘ　ダイヤモンド

(f) diamond;

十九　レジストであって、次のいずれかに該当するもの又はそれを塗布した基板

(xix) resists that fall under any of the following sub-items, or substrates to which the resists have been applied:

イ　半導体用のリソグラフィに使用するレジストであって、次のいずれかに該当するもの

(a) resists used in lithography for semiconductors, which fall under any of the following resists:

（一）　一五ナノメートル以上一九三ナノメートル未満の波長の光で使用するように最適化したポジ型レジスト

1. positive tone resists optimized to be used for light with a wavelength of 15 nanometers or more and less than 193 nanometers; or

（二）　一ナノメートル超一五ナノメートル未満の波長の光で使用するように最適化したレジスト

2. resists optimized to be used for light with a wavelength of more than 1 nanometer and less than 15 nanometers;

ロ　電子ビーム又はイオンビームで使用するために設計したレジストであって、〇・〇一マイクロクーロン毎平方ミリメートル以下の感度を有するもの

(b) resists that are designed to be used in electron beams or ion beams, which have a sensitivity of 0.01 microcoulombs per square millimeter or less;

ハ　削除

(c) Deleted

ニ　表面イメージング技術用に最適化したレジスト

(d) resists that are optimized for surface imaging technology;

ホ　第十七号ヘ（二）に該当するインプリントリソグラフィ装置に使用するように設計又は最適化したレジストであって、熱可塑性又は光硬化性のもの

(e) resists that are designed or optimized to be used in imprint lithography equipment falling under item (xvii), (f), clause 2, which are thermoplastic or photocurable;

二十　有機金属化合物又は有機化合物であって、次のいずれかに該当するもの

(xx) organometallic compounds or organic compounds that fall under either of the following sub-items:

イ　アルミニウム、ガリウム又はインジウムの有機金属化合物であって、純度が九九・九九九パーセントを超えるもの

(a) aluminum, gallium, or indium organic compounds with a purity exceeding 99.999%; or

ロ　燐、砒素又はアンチモンの有機化合物であって、純度が九九・九九九パーセントを超えるもの

(b) phosphorus, arsenic, or antimony organic compounds with a purity exceeding 99.999%;

二十一　燐、砒素又はアンチモンの水素化物であって、純度が九九・九九九パーセントを超えるもの（二〇モルパーセント以上の不活性ガス又は水素を含んだものを除く。）

(xxi) phosphorus, arsenic, or antimony hydrides with a purity exceeding 99.999% (excluding those that contain inert gasses of 20 mole percent or more, or that contain hydrogen);

二十二　炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム、窒化アルミニウムガリウム、

三酸化二ガリウム又はダイヤモンドの半導体基板又はインゴット、ブール若しくはその他のプリフォームであって、二〇度の温度における電気抵抗率が一〇、〇〇〇オームセンチメートルを超えるもの

(xxii) semiconductor substrates or ingots, boules, or other preforms of silicon carbide, gallium nitride, aluminum nitride, aluminum gallium nitride, digallium trioxide, or diamond whose electrical resistivity at a temperature of 20 degrees centigrade exceeds 10,000 ohm centimeters;

二十三　多結晶基板又は多結晶セラミック基板であって、二〇度の温度における電気の抵抗率が一〇、〇〇〇オームセンチメートルを超えるもののうち、当該基板の表面にシリコン、炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム、窒化アルミニウムガリウム、三酸化二ガリウム又はダイヤモンドの非エピタキシャル単結晶層を少なくとも一層以上有するもの

(xxiii) among polycrystalline substrates or polycrystalline ceramic substrates whose electrical resistivity at a temperature of 20 degrees centigrade exceeds 10,000 ohm centimeters, those which have on their surface, at least one or more non-epitaxial single crystal layers of silicon, silicon carbide, gallium nitride, aluminum nitride, aluminum gallium nitride, digallium trioxide, or diamond;

二十四　前二号のいずれかに該当する基板であって、当該基板の上に炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム、窒化アルミニウムガリウム、三酸化二ガリウム又はダイヤモンドのエピタキシャル層を少なくとも一層以上有するもの（第十八号に該当するものを除く。）

(xxiv) substrates that fall under either of the preceding two items, which have on them at least one or more epitaxial layers of silicon carbide, gallium nitride, aluminum nitride, aluminum gallium nitride, digallium trioxide, or diamond (excluding those falling under item (xviii)).

第七条　輸出令別表第一の八の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 7 The goods with specifications prescribed by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 8 of the Appended Table 1 of the Export Order are those that fall under any of the following items:

一　電子計算機若しくはその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品

(i) computers or their auxiliary equipment which falls under any of the following sub-items, or their components:

イ　八五度を超える温度又は零下四五度より低い温度で使用することができるように設計したもの

(a) those that are designed to be capable of using at temperatures exceeding 85 degrees centigrade or lower than 45 degrees below zero centigrade;

ロ　放射線による影響を防止するように設計したものであって、次のいずれかに該

当するもの

(b) those that are designed to prevent the impact of radiation, which fall under any of the following clauses:

（一）　全吸収線量がシリコン換算で五、〇〇〇グレイを超える放射線照射に耐えられるように設計したもの

1. those that are designed to withstand atomic radiation with a total absorbed dose exceeding 5,000 grays on a silicon conversion basis;

（二）　吸収線量がシリコン換算で一秒間に五、〇〇〇、〇〇〇グレイを超える放射線照射により障害を発生しないように設計したもの

2. those that are designed not to cause impediment from an absorbed dose of atomic radiation exceeding 5 million grays per second on a silicon conversion basis;

（三）　単事象障害によるエラー率が一日当たり一億分の一毎ビット未満となるように設計したもの

3. those that are designed to have an error of less than 1/100 million per 1 bit per day for a single event error;

二　削除

(ii) Deleted

三　デジタル電子計算機、その附属装置若しくはデジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、次のロ、ハ若しくはトのいずれかに該当するもの又はこれらの部分品（次のチからヌまでのいずれかに該当するもの及びこれらの部分品を除く。）

(iii) digital computers, their auxiliary equipment or components designed to improve the functions of digital computers, which fall under any of the following sub-item (b), (c), or (g), or their components (excluding those that fall under any of the following sub-items (h) through (j) and their components):

イ　削除

(a) Deleted

ロ　デジタル電子計算機であって、加重最高性能が七〇実効テラ演算を超えるもの

(b) digital computers whose adjusted peak performance exceeds 70 weighted teraFLOPS;

ハ　デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が七〇実効テラ演算を超えるもの（最大性能が七〇実効テラ演算を超えないデジタル電子計算機又はそのファミリーの計算機用に特別に設計されたものを除く。）

(c) components that are designed to improve the functions of digital computers, whose adjusted peak performance exceeds 70 weighted teraFLOPS through gathering calculation elements (excluding digital computers whose maximum performance does not exceed 70 weighted teraFLOPS, or those specially designed for the computers of their families);

ニ　削除

(d) Deleted

ホ　削除

(e) Deleted

ヘ　削除

(f) Deleted;

ト　デジタル電子計算機の演算処理の能力を向上させるために複数のデジタル電子計算機の間でデータを転送するように設計した、デジタル電子計算機の附属装置であって、転送されるデータの転送速度が二・〇ギガバイト毎秒を超えるもの

(g) auxiliary equipment of digital computers which is designed to transfer data among several digital computers for the purpose of improving the arithmetic processing capacity of digital computers, which has a transfer rate of the data to be transferred that exceeds 2.0 gigabytes per second;

チ　他の装置に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必要不可欠であるもののうち、当該装置の主要な要素でないもの

(h) among functions that are installed in other devices and are indispensable for the operation of that device, those which are not the main element of that device;

リ　他の装置に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必要不可欠であるもののうち、その機能が当該装置の信号処理又は画像強調に限定されているもの

(i) among functions that are installed in other devices and are indispensable for the operation of that device, those whose functions are limited to signal processing or image enhancement of that device;

ヌ　輸出令別表第一の九の項（一）から（三）まで又は（五）から（五の五）までに掲げる貨物に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必要不可欠であるもの

(j) devices that are installed in the goods stated in row (9), (i) through (iii), or (v) through (v)-5 of the Appended Table 1 of the Export Order, which are indispensable for the operation of those devices;

四　電子計算機であって、次のいずれかに該当するもの又はその附属装置若しくは部分品

(iv) computers that fall under any of the following clauses, or their auxiliary equipment or components:

イ　シストリックアレイコンピュータ

(a) systolic array computers;

ロ　ニューラルコンピュータ

(b) neural computers;

ハ　光コンピュータ

(c) optical computers;

五　電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品であって、侵入プログラム

の作成、指揮統制又は配信を行うように特に設計又は改造されたもの

(v) computers or their auxiliary equipment, or their components, which are specially designed or modified to create, command and control, or distribute intrusion programs.

第八条　輸出令別表第一の九の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 8 The goods with specifications prescribed by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 9 of the Appended Table 1 of the Export Order are those that fall under any of the following items:

一　伝送通信装置、電子式交換装置、通信用の光ファイバー、フェーズドアレーアンテナ、監視用の方向探知機、無線通信傍受装置、通信妨害装置、無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置の作動を監視する装置、電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置又はインターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置であって、次のいずれかに該当するもの

(i) telecommunication transmission equipment, electronic switching device, telecommunication optical fiber, phased array antenna, radio direction finding equipment for monitoring, radio communication interception equipment, communication jamming equipment, equipment for monitoring operation of radio communication interception equipment or communication jamming equipment, equipment capable of detecting positions by observing the interference of radio waves or other electromagnetic waves without transmitting radio waves or other electromagnetic waves, or equipment for monitoring communication by the means of using the internet, which falls under any of the following sub-items:

イ　核爆発による過渡的な電子的効果又はパルスによる影響を防止することができるように設計したもの

(a) one that is designed to be capable of preventing transitional electronic effect due to nuclear explosions, or effect of electromagnetic pulses;

ロ　ガンマ線、中性子線又は重荷電粒子線による影響を防止することができるように設計したもの（人工衛星に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。）

(b) one that is designed to prevent the effect of gamma rays, neutron beams, or heavy charged particle beams (excluding one that is designed or modified to be loaded on artificial satellites);

ハ　零下五五度より低い温度で使用することができるように設計したものであって、電子回路を有するもの（人工衛星に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。）

(c) one that is designed to be usable at temperatures of lower than 55 degrees centigrade below zero and has electronic circuits (excluding one that is

designed or modified to be loaded on artificial satellites); or

ニ　一二四度を超える温度で使用することができるように設計したものであって、電子回路を有するもの（人工衛星に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。）

(d) one that is designed to be usable at temperatures exceeding 124 degrees centigrade and has electronic circuits (excluding one that is designed or modified to be loaded on artificial satellites);

二　伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品であって、次のいずれかに該当するもの

(ii) telecommunication transmission equipment, or their components or accessories, which fall under any of the following sub-items:

イ　無線送信機又は無線受信機であって、次のいずれかに該当するもの

(a) radio transmitters or radio receivers that fall under any of the following clauses:

（一）　一・五メガヘルツ以上八七・五メガヘルツ以下の周波数範囲で使用することができるものであって、次の１及び２に該当するもの

1. those that can be used within a frequency range of 1.5 megahertz or more and 87.5 megahertz or less, which fall under the following clauses i. and ii.:

１　最適送信周波数及び一チャネル当たりの最適総合伝送速度を自動的に予測及び選択することができるもの

i. those that are capable of automatically measuring and selecting the optimum transmission frequency and the optimum general transfer rate per channel;

２　次の一から四までのすべてに該当する線形増幅器を用いたもの

ii. those that use linear amplifiers falling under all of the following clauses a. through d.:

一　二つ以上の信号を同時に増幅することができるもの

a. those that are capable of amplifying two or more signals simultaneously;

二　一・五メガヘルツ以上三〇メガヘルツ未満の周波数範囲においては一キロワット以上の出力、三〇メガヘルツ以上八七・五メガヘルツ以下の周波数範囲においては二五〇ワット以上の出力特性を有するもの

b. those that have an output of 1 kilowatt or more within a frequency range of 1.5 megahertz or more and less than 30 megahertz, and an output characteristics of 250 watts or more within a frequency range of 30 megahertz or more and 87.5 megahertz or less;

三　一オクターブ以上の瞬時帯域幅を有するもの

c. those that have an instantaneous bandwidth of 1 octave or more; and

四　信号波に対する高調波又は歪成分の比がマイナス八〇デシベル未満のもの

d. those for which the ratio of harmonics or distortion component to signal waves is less than minus 80 decibels;

（二）　スペクトル拡散（周波数ホッピングを含む。）技術を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの（（三）に該当するもの又は出力が一・〇ワット以下のものを除く。）

2. those that use spread spectrum technique (including frequency hopping), which fall under any of the following clauses (excluding those falling under clause 3., or those with an output of 1.0 watts or less):

１　使用者によって拡散符号の書換えができるもの

i. those for which the user is able to rewrite the spreading code;

２　送信帯域幅が情報チャネルの帯域幅の一〇〇倍以上であり、かつ、五〇キロヘルツを超えるもの（民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したもの又は商用民生通信の固定若しくは移動の衛星通信地球局に使用するように設計したものを除く。）

ii. those having a transmission bandwidth that is 100 times or more of the bandwidth of the information channel, and, that exceeds 50 kilohertz (excluding those designed to be used for cellular radio communication for civilian use, or designed to be used for fixed or mobile satellite communication earth stations for commercial civilian communication);

（三）　ウルトラワイドバンド変調技術を用いたものであって、使用者によってチャンネル符号、スクランブル符号又はネットワーク認識符号の書換えができるもののうち、次のいずれかに該当するもの

3. among those that use ultra wideband modulation technique and which the user is able to rewrite the channelizing codes, scrambling codes, or network identification codes, those that fall under any of the following clauses:

１　帯域幅が五〇〇メガヘルツを超えるもの

i. those with a bandwidth exceeding 500 megahertz;

２　瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が二〇パーセント以上のもの

ii. those for which the value obtained by dividing the instantaneous bandwidth by the center frequency is 20% or more;

ロ　デジタル信号処理機能を有するものであって、音声帯域圧縮技術を用いたもののうち、符号化速度が七〇〇ビット毎秒未満のもの

(b) among those that have a digital signal processing function and use voice band compression technique, those with a coding speed of less than 700 bits per second;

ハ　水中で使用することができるように設計した通信装置であって、次のいずれかに該当するもの（有線で結ばれていないものに限る。）

(c) those that are designed to be used underwater, which fall under any of the following clauses (limited to those that have a wired connection):

（一）　音波（超音波を含む。）を利用したものであって、搬送周波数が二〇キロヘルツ未満又は六〇キロヘルツを超えるもの

1. those that use sound waves (including ultrasonic waves), which have a

carrier frequency of less than 20 kilohertz or exceeding 60 kilohertz;

（二）　電磁波を利用したものであって、搬送周波数が三〇キロヘルツ未満のもの

2. those which use electromagnetic waves, which have a carrier frequency of less than 30 kilohertz;

（三）　電子的にビームを走査する機能を有するもの

3. those that have a function of electronically scanning beams;

（四）　レーザー発振器又は発光ダイオードを使用したものであって、これらの出力波長が四〇〇ナノメートル超七〇〇ナノメートル未満であり、かつ、ローカルエリアネットワークにおいて用いられるもの

4. those using laser oscillators or light emitted diodes whose output wavelength is more than 400 nanometers and 700 nanometers or less, and, which are used in local area networks;

三　削除

(iii) Deleted

四　通信用の光ファイバーであって、長さが五〇〇メートルを超えるもののうち、引張強さが二ギガニュートン毎平方メートル以上のもの

(iv) among communication optical fibers with a length exceeding 500 meters, those that have a tensile strength of 2 giganewtons per square meter or more;

五　電子的に走査が可能なフェーズドアレーアンテナであって、次のイからニまでのいずれかで使用することができるように設計したもの（国際民間航空機関の標準に準拠したマイクロ波着陸システム（ＭＬＳ）用のもの及びホからトまでのいずれかに該当するもののために特に設計したものを除く。）

(v) phased array antennas capable of electronic scanning, which are designed to be used for devices referred to in any of the following sub-items (a) through (d) (excluding those for microwave landing systems (MLS) which conform to the standards of the International Civil Aviation Organization, and those specially designed for devices falling under any of the sub-items (e) through (g));

イ　周波数が三一・八ギガヘルツ超五七ギガヘルツ以下であって、実効輻射電力（ＥＲＰ）が二〇ディービーエム（等価等方輻射電力（ＥＩＲＰ）が二二・一五ディービーエム）以上のもの

(a) those whose frequencies are more than 31.8 gigahertz and 57 gigahertz or less, with an effective radiated power (ERP) of 20 dBm (equivalent isotropic radiated power (EIRP) is 22.15 dBm) or more;

ロ　周波数が五七ギガヘルツ超六六ギガヘルツ以下であって、実効輻射電力（ＥＲＰ）が二四ディービーエム（等価等方輻射電力（ＥＩＲＰ）が二六・一五ディービーエム）以上のもの

(b) those whose frequencies are more than 57 gigahertz and 66 gigahertz or less, with an effective radiated power (ERP) of 24 dBm (equivalent

isotropic radiated power (EIRP) is 26.15 dBm) or more;

ハ　周波数が六六ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下であって、実効輻射電力（ＥＲＰ）が二〇ディービーエム（等価等方輻射電力（ＥＩＲＰ）が二二・一五ディービーエム）以上のもの

(c) those whose frequencies are more than 66 gigahertz and 90 gigahertz or less, with an effective radiated power (ERP) of 20 dBm (equivalent isotropic radiated power (EIRP) is 22.15 dBm) or more;

ニ　周波数が九〇ギガヘルツを超えるもの

(d) those whose frequencies exceed 90 gigahertz;

ホ　民生用のセルラー無線通信又は無線ローカルエリアネットワーク

(e) cellular radio communications or radio local area networks, for civilian use;

ヘ　ＩＥＥＥ八〇二・一五又は無線化された高精細度マルチメディアインターフェース

(f) IEEE 802.15 or wireless high-definition multimedia interfaces; or

ト　商用民生通信の固定又は移動の衛星通信地球局

(g) fixed or mobile satellite communication earth stations for commercial civilian communication;

五の二　動作周波数が三〇メガヘルツを超える監視用の方向探知機であって、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品

(v)-2 radio direction finder for monitoring with an operating frequency exceeding 30 megahertz, which falls under the following sub-items (a) and (b), or their components:

イ　一〇メガヘルツ以上の瞬時帯域幅を有するもの

(a) one that has an instantaneous bandwidth of 10 megahertz or more;

ロ　一ミリ秒未満の信号時間で、連携していない無線送信機に対する方位線を見つけることができるもの

(b) one that is capable of finding an azimuth line to non-cooperating radio transmitters with a signal duration of less than 1 millisecond;

五の三　無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置若しくはこれらの作動を監視する装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品

(v)-3 radio communication interception equipment or communication jamming equipment or devices that monitor their operations, which fall under any of the following sub-items, or their components:

イ　無線通信により送信される音声又はデータを抽出するように設計された無線通信傍受装置

(a) radio communication interception equipment that is designed to extract voice or data transmitted through radio communication;

ロ　無線通信により送信される移動体通信機器又は加入者を特定するために必要な識別情報、制御信号、他のメタデータを抽出するように設計された無線通信傍受装置

(b) radio communication interception equipment that is designed to extract identification information, control signals, or other metadata that are transmitted through radio communication necessary for identifying mobile communication devices or subscribers;

ハ　移動体通信に意図的かつ選択的に干渉し、若しくはこれを意図的かつ選択的に阻害し、途絶させ、減退させ、若しくは誘引するように設計した通信妨害装置のうち、次のいずれかに該当するもの

(c) among communication jamming equipment that is designed to intentionally and selectively interfere with or intentionally or selectively hinder, block, reduce or induce mobile communication, those that falls under any of the following clauses:

（一）　無線アクセスネットワークの機能を装うもの

1. one that simulates the functions of radio access network;

（二）　使用されている移動体通信プロトコルを探知し、かつ、これを利用するもの

2. one that detects, and, utilizes the mobile telecommunications protocol used;

（三）　使用されている移動体通信プロトコルを利用するもの（（二）に該当するものを除く。）

3. one that utilizes the mobile telecommunications protocol used (excluding one that falls under clause 2.);

ニ　イからハまでのいずれかに該当する装置の作動を監視するために設計された装置

(d) equipment that is designed to monitor the operations of equipment that falls under any of the clauses (a) through (c);

五の四　電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置であって、非レーダー発信機により周囲に発信された無線周波数放射の反射を測定することにより移動している目標物を探知し、及び追跡するように設計したもの

(v)-4 equipment capable of detecting positions by observing the interference of radio waves or other electromagnetic waves, without transmitting radio waves or other electromagnetic waves, which is designed to detect and track moving targets by measuring the reflections of ambient radio frequency emissions transmitted by non-radar transmitters;

五の五　インターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置又はその部分品であって、次のイ及びロに該当するもの（マーケティング活動、ネットワークのサービス品質管理又は利用者の体感品質管理のために設計された装置を除く。）

(v)-5 equipment for monitoring the content of communication by the means of using the internet, or its components, which fall under the following sub-items (a) and (b) (excluding equipment that is designed for conducting

marketing activities, quality management of network services, or quality management of user experience):

イ　キャリアクラスのＩＰネットワーク上で次の（一）から（三）までの全ての機能を実現するもの

(a) those that realize all of the functions referred to in the following clauses 1. through 3. on a carrier-class IP network:

（一）　アプリケーション層の分析

1. analysis of the application layer;

（二）　選択されたメタデータ及びアプリケーションの内容の抽出

2. extraction of selected metadata and content of applications;

（三）　抽出したデータの指標付け

3. indexing of extracted data;

ロ　次の（一）及び（二）を実行するために設計したもの

(b) those that are designed to perform the functions referred to in the following clauses 1. and 2.:

（一）　ハードセレクターに基づく検索

1. retrieval based on hardware selector;

（二）　特定の個人又は集団の関係の解析

2. analysis of relationship between specific individuals or groups;

六　第二号イ（二）、第十四条第五号若しくは第五号の二に該当する貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品

(vi) devices for designing, manufacturing, measuring, or testing the goods that fall under item (ii), sub-item (a), clause 2., Article 14, item (v) or (v)-2, or their components or accessories;

七　前号に掲げるもののほか、第一号、第二号、第四号若しくは第五号から第五号の五までのいずれかに該当する貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置若しくは試験装置（光ファイバーの試験装置及び測定装置を除く。）又はこれらの部分品若しくは附属品

(vii) beyond what is stated in the preceding item, devices for designing, manufacturing, measuring, or testing goods (excluding optical fiber testing equipment and measuring equipment) that fall under any of item (i), item (ii), item (iv), or items (v) through (v)-5, or their components or accessories;

八　削除

(viii) Deleted

八の二　次のいずれかに該当する伝送通信装置若しくは電子式交換装置の設計用の装置又はその部分品若しくは附属品（第六号に該当するものを除く。）

(viii)-2 devices for designing telecommunication transmission equipment or electronic switching device that fall under any of the following sub-items, or their components or accessories (excluding those that fall under item (vi)):

イ　レーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの

(a) those using laser oscillators which fall under any of the following clauses:

（一）　一、七五〇ナノメートルを超える波長のレーザー光を利用するもの

1.those that utilize laser light having a wavelength of more than 1,750 nanometers;

（二）　削除

2. Deleted

（三）　削除

3. Deleted

（四）　アナログ伝送方式を用いたものであって、帯域幅が二・五ギガヘルツを超えるもの（テレビジョン放送（有線テレビジョン放送を含む。）用の装置を除く。）

4. those use an analog transmission system with a bandwidth exceeding 2.5 gigahertz (excluding devices for television broadcasting (including CATV broadcasting));

ロ　無線送信機又は無線受信機であって、一、〇二四値を超える直交振幅変調技術を用いたもの

(b) radio transmitters or radio receivers that use quadrature amplitude modulation technology for values exceeding 1,024;

九　暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品であって、次のイからホまでのいずれかに該当するもの（第三条第十九号ハ（二）２、本号へ、第十一号又は第十条第五号イに該当するものを除く。）

(ix) cryptographic equipment or components for realizing cryptographic functions, which fall under any of the following sub-items (a) through (e) (excluding those falling under Article 3, item (xix), sub-item (c), clause 2., ii., sub-item (f) of this item, item (xi), or Article 10, item (v), sub-item (a)):

イ　対称アルゴリズムを用いたものであって対称鍵の長さが五六ビットを超えるもの又は非対称アルゴリズム（アルゴリズムの安全性が次の（一）から（六）までのいずれかに該当する困難性に基づくものに限る。以下この号において同じ。）を用いたものであって、データの機密性確保のための暗号機能を有するように設計し、又は改造したもの（当該暗号機能を使用することができるもの（当該暗号機能が有効化されているものを含む。）又は安全な仕組みの暗号機能有効化の手段以外の手段で暗号機能を有効化できるものに限る）のうち、次の（七）から（十）までのいずれかに該当するもの（（十一）から（二十）までに該当するものを除く。）

(a) among those using a symmetric algorithm and with a symmetric key with a length exceeding 56 bits, or using an asymmetric algorithm (limited to an asymmetric algorithm for which the security of the algorithm is based on the difficulty falling under any of the following clauses 1. through 6.; the same applies below in this item) which are designed or modified to have a cryptographic function for securing confidentiality of data (limited to those capable of using the cryptographic function (including those whose

cryptographic function has been activated), or those capable of activating the cryptographic function by means other than the means of activating the cryptographic function with a safe mechanism), those which fall under any of the following clauses 7. through 10. (excluding those falling under clauses 11. through 20.):

（一）　五一二ビットを超える整数の素因数分解

1. prime factorization of integers exceeding 512 bits;

（二）　有限体上の乗法群における五一二ビットを超える離散対数の計算

2. calculation of discrete logarithms in a multiplicative group of a finite field of size greater than 512 bits;

（三）　（二）に規定するもの以外の群における一一二ビットを超える離散対数の計算

3. calculation of a discrete logarithm of a size greater than 112 bits in a group other than the group prescribed in 2.;

（四）　格子に関連する最短ベクトル又は最近接ベクトル問題

4. problem of the shortest vector or the closest vector associated with lattices;

（五）　超特異楕円曲線間の同種写像の探索

5. exploration of isogenies between supersingular elliptical curves;

（六）　ランダムな符号の復号

6. decoding random codes;

（七）　情報システムのセキュリティ管理機能を主たる機能として有するもの

7. those that have a security management function for information systems as the primary function;

（八）　デジタル通信装置、有線若しくは無線回線網による電気通信回線を構築、管理若しくは運用するための装置又はこれらの部分品（（七）に該当するものを除く。）

8. digital communication devices or devices for constructing, managing, or operating telecommunication lines using a wired or wireless network, or their components (excluding those falling under clause 7.);

（九）　電子計算機若しくは情報の記録及び保存若しくは処理を主たる機能として有するもの又はこれらの部分品（（七）又は（八）に該当するものを除く。）

9. computers or devices that have the primary function of recording and storing or processing information, or their components (excluding those falling under clause 7. or 8.):

（十）　次の１及び２に該当するもの（（七）から（九）までに該当するものを除く。）

10. those that fall under the following clauses i. and ii. (excluding those falling under clauses 7. through 9.):

１　当該貨物の有する暗号機能が当該貨物の主たる機能以外の機能を支援するために用いられているもの

i. the cryptographic function of the goods is used to support functions other than the primary function of those goods; and

２　当該貨物の有する暗号機能が当該貨物に組み込まれたもの（この号から第十二号までのいずれかに該当するものに限る。）又は第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号、第九号の二若しくは第十七号のいずれかに該当するプログラム（公開されているものを除く。）によって実現されているもの

ii. the cryptographic function of the goods is realized through smart cards incorporated in those goods (limited to those falling under any of the items from this item to item (xii)), or programs falling under any of Article 21, paragraph (1), item (vii), item (vii)-2, item (viii)-2, item (viii)-3, item (ix), item (ix)-2, or item (xvii) (excluding those opened to the public);

（十一）　暗号機能を有するスマートカード若しくはそのリーダライタであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品

11. smart cards having a cryptographic function or their reader/writer, which falls under any of the following clauses, or their components:

１　スマートカードであって、次のいずれかに該当するもの

i. smart cards that fall under any of the following clauses:

一　次のいずれかに該当するものに限定されて使用するものであって、他の用途のためにプログラムの書き換えを行うことができないもの

a. those that are used only for a device falling under any of the following clauses, which cannot rewrite programs for other uses:

イ　（七）から（十）までのいずれにも該当しないもの

1 those that do not fall under any of clauses 7. through 10.;

ロ　対称アルゴリズムを用いたものであって対称鍵の長さが五六ビットを超えるもの又は非対称アルゴリズムを用いたものであって、データの機密性確保のための暗号機能を有するように設計したもの以外のもの

2 those other than those using a symmetric algorithm with a symmetric key whose length exceeds 56 bits, or those using an asymmetric algorithm which are designed to have a cryptographic function for securing confidentiality of data;

ハ　（十二）から（十六）までに該当するもの

3 those that fall under clauses 12. through 16.;

二　個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの（認証及び金銭債権に係るものその他これらに類するものを含む。）を含む。）をいう。（十一）において同じ。）又は団体情報（法人その他の団体の情報であって、認証及び金銭債権に係るものその他これらに類するものを含む。（十一）において同じ。）に係る情報が記録され、又は記録されるように設計したものであって、次のイからハまでの全てに該当するもの

b. those on which information related to personal information (meaning information about a living individual which can identify a specific individual by the name, date of birth or other descriptions contained in that information (including information that can be easily collated with other information and identify a specific individual by the collation (including information related to authentication and monetary claims or other similar information)); the same applies in clause 11.), or organization information (including information about a corporation or other organizations which is related to authentication and monetary claims or other similar information; the same applies in clause 11.) is recorded, or are designed to record the information, which fall under all of the following clauses 1 through 3:

イ　暗号機能を専ら当該スマートカードに記録された個人情報又は団体情報の保護のためにのみ使用するもの

1 those whose cryptional function is exclusively used to protect personal information or organization information recorded in the smart card;

ロ　専ら公共施設若しくは商業施設において使用し、又は当該スマートカードに記録された個人情報又は団体情報に係る情報の認証のために使用するもの

2 those exclusively used at public facilities or commercial facilities, or for authentication of information on the personal information or organization information recorded on the smart card; and

ハ　当該スマートカードを使用する者が当該スマートカードの有する暗号機能を変更することができないもの

3 those whose cryptographic function cannot be modified by the user of the smart card;

２　リーダライタであって、専ら１に該当するスマートカードに記録された個人情報若しくは団体情報に係る情報を読み取り、又は当該スマートカードに個人情報若しくは団体情報に係る情報を記録するように設計し、又は改造したもの（電気通信回線を通じて読み取り、又は記録するものを含む。）

ii. a reader/writer exclusively designed or modified to read information on personal information or organization information recorded on the smart card falling under clause i., or to record information on personal information or organization information on the smart card (including those which read or record the information through a telecommunications line);

（十二）　暗号装置であって、銀行業務若しくは決済（料金の徴収及び精算又は割賦販売法（昭和三十六年法律第百五十九号）第二条第三項に規定する包括信用購入あつせんに係る業務を含む。）に使用するように設計したもの又はその部分品

12. cryptographic equipment designed to be used for banking business or settlement of accounts (including business related to collection and settlement of fees, or intermediation of comprehensive credit purchases as

defined in Article 2, paragraph (3) of the Installment Sales Act (Act No. 159 of 1961)), or their components;
（十三）　民生用の携帯用電話機端末（携帯回線網用の電話その他の無線回線網用の電話をいう。（十五）において同じ。）若しくは移動用電話機端末（専ら自動車その他の移動体において使用するように設計したものをいう。（十五）において同じ。）であって、次の１及び２に該当するもの又はこれらの部分品
13. portable phone terminals (meaning telephones for portable phone networks or other telephones for wireless networks; the same applies in clause 15.) or mobile phone terminals (those exclusively designed to be used for automobiles or other moving bodies; the same applies in clause 15.) for civilian use, which fall under the following clauses i. and ii., or their components:
１　他の電話機端末その他の装置（無線アクセスネットワーク装置を除く。）に暗号化されたデータを直接送信することができないもの
i. those incapable of transmitting encrypted data directly to another telephone terminal or other devices (excluding radio access network equipment); and
２　無線ネットワーク制御装置、基地局制御装置その他の無線アクセスネットワーク装置を経由して暗号化されたデータを伝達することができないもの
ii. those incapable of conveying data encrypted through a radio network controller, base station controller, or other radio access network equipment;
（十四）　コードレス電話機端末間での暗号化機能を有しないコードレス電話装置であって、コードレス電話機端末と家庭内基地局の間に無線中継器がない場合の一無線区間での電波到達最長実効距離が四〇〇メートル未満のもの又はその部分品
14. cordless telephone equipment that does not have an encryption function between cordless phone terminals, whose maximum effective radio wave range is less than 400 meters in one radio section when there is no radio repeater between a cordless phone terminal and a home base station, or their components;
（十五）　民生用の携帯用電話機端末若しくは移動用電話機端末又は同等の無線機端末であって、公開された又は商業用の暗号標準（無断の複製を防止するためのものであって、公開されていないものを含む。）のみを用いたもののうち、暗号機能が使用者によって変更できず、使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計したもので、かつ、特定の民生産業用途に用いるために設計を変更したもの（暗号機能を変更していないものに限る。）又はこれらの部分品
15. among portable phone terminals or mobile phone terminals for civilian use, or radio terminals equivalent to them, which use only encryption standards that are opened to the public or for commercial use (including

those for preventing unauthorized reproduction which is not opened to the public), those for which users cannot alter the cryptographic function and are designed to not require technical assistance from suppliers or distributors in using them, and, whose design has been modified for them to be used for specific civilian use and specific industrial use (limited to those whose cryptographic function has not been modified), or their components;

（十六）　無線パーソナルエリアネットワークに用いられる装置であって、公開された若しくは商業用の暗号標準のみを用いたもの又はその部分品

16. devices used for wireless personal area networks which use only encryption standards that are opened to the public or for commercial use, or their components;

（十七）　民生用に設計した移動体通信用の無線アクセスネットワーク装置であって、暗号機能が使用者によって変更できず、使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計したもののうち、無線周波数の出力が〇・一ワット（二〇ディービーエム）以下で、かつ、同時に接続できるデバイスが十六以下のもの又はその部分品

17. among wireless access network devices for mobile communications designed for civilian use, for which users cannot alter the cryptographic function and are designed not to require technical assistance from suppliers or distributors in using them, those whose radio frequency output is 0.1 watt (20 dBm) or less, and, for which the number of devices that can be simultaneously connected is sixteen or less, or their components;

（十八）　ルーター、スイッチ、ゲートウェイ若しくはリレーであって、情報システムのセキュリティ管理機能が装置の操作、管理若しくは保守に関するものに限定されており、かつ、公開された若しくは商業用の暗号標準のみを用いたもの又はこれらの部分品

18. routers, switches, gateways or relays, whose security management function for the information system is limited to that related to the operation, management or maintenance of the devices, and, which use only encryption standards that are opened to the public or for commercial use, or their components;

（十九）　汎用目的の計算機能を有する装置若しくはサーバーであって、情報システムのセキュリティ管理機能が次の１及び２に該当するもの又はこれらの部分品

19. general-purpose devices or servers that have a calculation function, whose security management function for the information system falls under the following clauses i. and ii., or their components:

１　公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたもの

i. those that use only encryption standards that are opened to the public or for commercial use; and

２　次のいずれかに該当するもの

ii. those that fall under any of the following clauses:

一　へに該当する中央演算処理装置において実現されているもの

a. those that are realized in the central processing unit that fall under sub-item (f);

二　オペレーティングシステム（第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号、第九号の二又は第十七号のいずれかに該当するものを除く。）において実現されているもの

b. those that are realized in the operating system (excluding those that fall under any of Article 21, paragraph (1), item (vii), item (vii)-2, item (viii)-2, item (viii)-3, item (ix), item (ix)-2, or item (xvii)); or

三　装置の操作、管理又は保守に限定されているもの

c. those whose function is limited to the operation, management, or maintenance of a device;

（二十）　ネットワークに接続する民生産業用途のために設計したものであって、次の１及び２に該当するもの又はこれらの部分品

20. those that are to be connected to a network and are designed for civilian use or industrial use, which fall under the following clauses i. and ii., or their components:

１　次のいずれかに該当するもの

i. those which fall under any of the following clauses:

一　ネットワークに接続可能な端末であって、次のいずれかに該当するもの

a. terminals connectable to a network, which fall under any of the following clauses:

イ　情報システムのセキュリティ管理機能が、任意でないデータの秘匿又は操作、管理若しくは保守に限定されているもの

1 those whose security management function for the information system is limited to concealing, operating, managing, or maintaining non-arbitrary data;

ロ　ネットワークに接続する特定の民生産業用途に限定されているもの

2 those whose use is limited to specific civilian use or specific industrial use to connect to a network;

二　ネットワーク装置であって、次のイ及びロに該当するもの

b. network devices that fall under the following clauses 1 and 2:

イ　一に該当する端末と通信するために設計したもの

1 those designed for communicating with a terminal that fall under clause a.; and

ロ　情報システムのセキュリティ管理機能が、一に該当する端末のネットワークに接続する民生産業用途の支援に限定されているもの、又は当該ネットワーク装置若しくは本号イ（二十）に該当する他の貨物の操作、管理若しくは保守に限定されているもの

2 those whose security management function for the information system is limited to the support for civilian use or industrial use for connecting to the network of a terminal that falls under clause a., or to the operation, management, or maintenance of the network device or other goods that fall under sub-item (a), clause 20. of this item;

２　情報システムのセキュリティ管理機能が、公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたものであって、当該貨物の有する暗号機能が当該貨物を使用する者によって変更できないもの

ii. those whose security management function for the information system only use encryption standards that are opened to the public or for commercial use, for which users cannot change the cryptographic function that the goods have;

ロ　暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムの暗号機能を有効化するものであって、次のいずれかに該当するもの

(b) those that activate a cryptographic function of certain goods or programs only by using the means of activating the cryptographic function, which fall under any of the following clauses:

（一）　ある貨物（本号から第十二号までに該当しないものに限る。）を本号イに該当するもの（本号へに該当しないものに限る。）に変換し、又はあるプログラム（第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号、第九号の二又は第十七号に該当しないものに限る。）を第二十一条第一項第九号（第八条第九号イ又はハからホまでに係るものに限る。）に該当するものに変換するように設計し、若しくは改造したもの

1. those designed or modified to convert certain goods (limited to those that do not fall under this item through item (xii)) into those falling under sub-item (a) of this item (limited to those that do not fall under sub-item (f) of this item), or to convert certain programs (limited to those that do not fall under Article 21, paragraph (1), item (vii), item (vii)-2, item (viii)-2, item (viii)-3, item (ix), item (ix)-2, or item (xvii)) into those falling under Article 21, paragraph (1), item (ix) (limited to those related to Article 8, item (ix), sub-item (a), or sub-items (c) through (e));

（二）　本号から第十二号までのいずれかに該当するもの又は第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号若しくは第九号の二に該当するプログラムに本号イに該当する貨物の有する機能と同等の機能を追加することができるように設計し、若しくは改造したもの

2. those designed or modified so as to be capable of adding a function equivalent to the function of the goods that fall under sub-item (a) of this item to those that fall under any of this item through item (xii), or the programs that fall under Article 21, paragraph (1), item (vii), item (vii)-2, item (viii)-2, item (viii)-3, item (ix) or item (ix)-2;

ハ　量子暗号を用いるように設計し、又は改造したもの

(c) those that are designed or modified to use quantum cryptography;

ニ　次のいずれかに該当するウルトラワイドバンド変調技術のためのチャンネル符号、スクランブル符号又はネットワーク認識符号の生成に暗号処理技術を用いるように設計し、又は改造したもの

(d) those that are designed or modified to use cryptographic processing technique for generating channelizing codes, scrambling codes, or network identification codes for ultra-wideband modulation technique that fall under any of the following clauses:

（一）　帯域幅が五〇〇メガヘルツを超えるもの

1. those whose bandwidth exceeds 500 megahertz; or

（二）　瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が二〇パーセント以上のもの

2. those for which the value obtained by dividing the instantaneous bandwidth by the center frequency is 20% or more;

ホ　スペクトル拡散のための拡散符号の生成（周波数ホッピングのためのホッピング符号の生成を含む。）に暗号処理技術を用いるように設計し、又は改造したもの（ニに該当するものを除く。）

(e) those which are designed or modified to use cryptographic processing techique for generating the spreading code for spectrum spreading (including the generation of the hopping code for frequency hopping) (excluding those that fall under sub-item (d));

ヘ　次の（一）又は（二）のいずれかに該当するもの（該当することが貨物の製造者、販売者又は輸出者によって書面により確認できるものに限る。）

(f) those that fall under either of the following clause 1. or 2. (limited to those for which the fact that they fall under the clause can be confirmed by the manufacturer, seller, or exporter of the goods in writing):

（一）　次の１から３までの全てに該当するもの

1. those that fall under all of the following clauses i. through iii.:

１　購入に際して何らの制限を受けず、店頭において又は郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便若しくは公衆電気通信回線に接続した入出力装置（電話を含む。）による注文により、販売店の在庫から販売されるもの

i. those that are not subject to any restrictions for purchasing, which are sold at stores, or from the store's stock by placing orders by correspondence mail as defined in Article 2, paragraph (2) of the Act on Correspondence Delivery by Private Business Operators (Act No. 99 of 2002) by a general correspondence mail delivery operator as defined in paragraph (6) of that Article or a specified correspondence mail delivery operator as defined in paragraph (9) of that Article, or through input-output equipment connected to public telecommunication lines (including telephones);

２　当該貨物の有する暗号機能を当該貨物を使用する者によって変更できないも

の

ii. those for which the cryptographic function of the goods cannot be changed by the user of the goods;

３　当該貨物の有する暗号機能の使用に際して当該貨物の供給者又は販売店による技術支援の必要がないもの

iii. those for which technical support by the supplier or distributor of the goods is not required when using the cryptographic function of the goods;

（二）　（一）に該当する貨物のために設計された部分品であって、次の１から３までの全てに該当するもの

2. components that are designed for the goods that fall under clause 1., which fall under all of the following clauses i. through iii.:

１　情報システムのセキュリティ管理機能が当該部分品の主たる機能ではないもの

i. those whose security management function for the information system is not their primary function; or

２　（一）に該当する貨物の有する暗号機能を変更できず、かつ、当該貨物に新しい暗号機能を追加できないもの

ii. those that are not capable of changing the cryptographic function of the goods that fall under clause 1. have, and, are not capable of adding new cryptographic functions to the goods; and

３　当該部分品の機能が固定されており、特定の使用者のために設計し、又は改造していないもの

iii. those whose functions are fixed, which are not designed or modified for specific users;

十　暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品以外の情報システムのセキュリティ管理機能を実現する装置又は部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(x) devices or components for realizing a security management function for the information system other than cryptographic equipment or components for realizing cryptographic function, which fall under any of the following sub-items:

イ　盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品（盗聴の検知機能を実現するために設計し、又は改造した部分品に限る。）

(a) communication cable systems having the function of detecting wiretapping, or their components (limited to components designed or modified to realize the function of detecting wiretapping); or

ロ　情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造した装置（電磁波の放射による人体への危害若しくは他の装置の誤動作の誘発を防止することを目的として信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したもの又は電磁波妨害防止標準に基づいて信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したものを除く。）又はその部分品（情報を伝達する信号の漏えいを防止する機能を実現するために設計し、又は改造した部分品に限る。）

(b) devices that are designed or modified to prevent leakage of signals for conveying information (excluding those that are designed or modified to prevent leakage of signals for the purpose of preventing harm to the human body or malfunctions of other equipment due to radiation of electromagnetic waves, or equipment designed or modified to prevent leakage of signals in conformity with electromagnetic interference prevention standards), or their components (limited to components designed or modified to realize functions of preventing leakage of signals for conveying information);

十一　暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品のうち、情報システムのセキュリティ管理機能を無効化し、機能を低下させ又は迂回させるものであって、次のいずれかに該当するもの

(xi) among cryptographic equipment or components for realizing cryptographic functions, those for deactivating, degrading, or circumventing the security management function for the information system, which fall under either of the following sub-items:

イ　暗号解析を行うように設計し、又は改造したもの（リバースエンジニアリングの方法により暗号解析機能を実行するように設計し、又は改造したものを含む。）

(a) those that are designed or modified to perform cryptanalysis (including those designed or modified to implement cryptanalysis functions by the method of reverse engineering); or

ロ　電子計算機の端末又は通信端末から生データを抽出するもの（イ又は第七条第五号に該当するものを除く。）であって、その機能実現のために電子計算機の端末又は通信端末の認証又は承認制御を迂回することができるように設計したもの（電子計算機の端末又は通信端末の設計又は製造のために特に設計したシステム又は装置、若しくは次の（一）から（四）に掲げるものを除く。）

(b) those that extract raw data from computer terminals or communication terminals (excluding those that fall under clause (a) or Article 7, item (v)), which are designed to bypass the authentication or authorization control of computer terminals or communication terminals in order to achieve their functions (excluding systems or devices specially designed for designing or manufacturing computer terminals or communication terminals or those stated in the following clauses (1) through (4)):

（一）　デバッガ、ハイパーバイザー

1. debuggers and hypervisors;

（二）　論理データ抽出に限定されたもの

2. those that are limited to extract logical data;

（三）　チップオフやＪＴＡＧを使用してデータ抽出するもの

3. those that extract data by using chip-off or JTAG; and

（四）　ジェイルブレーキング又はルート化用に特別に設計されたもの

4. those specially designed for jailbreaking or rooting;

十二　第九号から前号までのいずれかに該当する貨物若しくは本号に該当する測定装置の設計用の装置若しくは製造用の装置又は第九号から前号までのいずれかに該当する貨物が有する情報システムのセキュリティ管理機能（第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号又は第九号の二のいずれかのプログラムが有する機能を含む。）を評価し、若しくは検証するための測定装置

(xii) devices for designing or manufacturing goods that fall under any of item (ix) through the preceding item or measuring instruments that fall under this item, or measuring equipment for evaluating or verifying security management function for the information system which the goods falling under any of item (ix) through the preceding item have (including the function that any program referred to in Article 21, paragraph (1), item (vii), item (vii)-2, item (viii)-2, item (viii)-3, item (ix), or item (ix)-2 has).

第九条　輸出令別表第一の一〇の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 9 (1) The goods with specifications prescribed by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 10 of the Appended Table 1 of the Export Order are those that fall under any of the following items:

一　音波（超音波を含む。以下この条において同じ。）を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(i) underwater detection equipment that uses sound waves (including ultrasonic waves; the same applies below in this Article), positioning device for vessels, or their components, which fall under any of the following sub-items:

イ　送信機能を有するもの又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの（垂直方向にのみ使用することができるものであって、プラスマイナス二〇度を超える走査機能を有していないもののうち、水深の測定、水中にある物体若しくは水底に埋もれた物体までの距離の測定又は魚群探知のみを行うもの及び音響用のビーコンであって、緊急用のもの又は水中の任意の位置に設置することができるように設計したピンガーを除く。）

(a) those having a transmission function, or their components, which fall under any of the following clauses (among those that may be used only in vertical directions, which do not have a scanning function exceeding plus or minus 20 degrees, excluding acoustic beacons that measure the depth of water, the distance to underwater objects or objects buried under water, or only find school of fish, which are for emergencies, or pingers that are designed so that they can be installed at any position under water):

（一）　音波を利用した海底測深機であって、次のいずれかに該当するもの

1. bathymetric survey equipment for sea bed using sound waves ,which falls under any of the following clauses:

１　海底の地形図を作成するための船舶用測深機であって、次の一から四までの全てに該当するもの

i. bathymetric survey equipment for vessels for creating bathymetric charts, which falls under all of the following clauses a. through d.:

一　垂直方向から二〇度を超える角度での測定ができるように設計したもの

a. one designed so as to enable to make a measurement at angles exceeding 20 degrees from the vertical direction;

二　水面下六〇〇メートルを超える海底の地形を測定することができるように設計したもの

b. one designed so as to enable to measure undersea topography at depths exceeding 600 meters under the water;

三　走査を行うときの分解能が二未満のもの

c. one with a resolving power of less than 2 at the time of scanning; and

四　次のイからハまでに掲げる全てについて自動的に補正を行い、測深の精度を向上させるもの

d. one that automatically corrects all of the actions stated in the following clauses 1 through 3 and improves the accuracy of bathymetry:

イ　センサーの動作

1 operation of sensors;

ロ　走査に用いる音波の状態

2 state of the sound waves used for scanning;

ハ　センサーが感知する音波の速度

3 speed of sound waves perceived by sensors;

２　海底の地形図を作成するための水中測深機であって、次のいずれかに該当するもの

ii. underwater bathymetric survey equipment for creating bathymetric charts, which falls under any of the following clauses:

一　三〇〇メートルを超える水深で作動するように設計又は改造したものであって、走査効率が三、八〇〇メートル毎秒を超えるもの

a. those designed or modified to operate at water depths exceeding 300 meters, whose scanning efficiency exceeds 3,800 meters per second;

二　次のイからニまでの全てに該当するもの（一に該当するものを除く。）

b. those that fall under all of the following clauses 1 through 4 (excluding those that fall under clause a.):

イ　一〇〇メートルを超える水深で作動するように設計又は改造したもの

1 those that are designed or modified to operate at water depths exceeding 100 meters;

ロ　垂直方向から二〇度を超える角度での測定ができるように設計したもの

2 those that are designed so as to enable to make a measurement at angles exceeding 20 degrees from the vertical direction;

ハ　動作周波数が三五〇キロヘルツ未満のもの又はセンサーから二〇〇メートルを

超える海底の地形を測定することができるように設計したもの
3 those with an operating frequency of less than 350 kilohertz, or that are designed so as to enable to measure undersea topography that is more than 200 meters away from the sensor;
ニ　次の（一）から（三）までの全てについて自動的に補正を行い、測深の精度を向上させるもの
4 those which automatically correct all of the actions stated in the following clauses [i] through [iii], and improve the accuracy of bathymetry:
（一）　センサーの動作
[i] operation of sensors;
（二）　走査に用いる音波の状態
[ii] state of the sound waves used for scanning and;
（三）　センサーが感知する音波の速度
[iii] speed of sound waves perceived by sensors;
３　海底の画像を作成するために設計したサイドスキャンソナー又は合成開口ソナーであって、次の一から三までの全てに該当するもの又はこれらの装置に使用するように設計した送受信音響アレー
iii. side scan sonars or synthetic aperture sonars designed to create an image of the seabed, which fall under all of the following clauses a. through c., or transmission and reception acoustic arrays designed to be used for those devices:
一　五〇〇メートルを超える水深で作動するように設計又は改造したもの
a. those designed or modified to operate at water depths exceeding 500 meters;
二　進行方向の分解能が一五センチメートル未満の状態で作動することができる最大レンジで作動しているときの走査範囲が一秒あたり五七〇平方メートルを超えるもの
b. those whose scanning field exceeds 570 square meters per second when they are operating at the maximum range in which they can operate in a state the resolving power in the direction of travel is less than 15 centimeters;
三　進行方向に直交する方向の分解能が一五センチメートル未満のもの
c. those with a resolving power in the direction perpendicular to the direction of travel of less than 15 centimeters;
（二）　水中探知装置であって、次のいずれかに該当するもの
2. underwater detection equipment that falls under any of the following clauses:
１　送信周波数が五キロヘルツ未満のもの又は動作周波数が五キロヘルツ以上一〇キロヘルツ未満であって、音圧レベル（音源から一メートルの距離で音圧が一マイクロパスカルである場合を〇デシベルとしたときのものをいう。以下同じ。）が二二四デシベルを超えるもの

i. one in which the transmission frequency is less than 5 kilohertz, or the operating frequency is 5 kilohertz or more and less than 10 kilohertz, and the sound pressure level (meaning the sound pressure level when the sound pressure is 1 micropascal at a distance of 1 meter from the sound source is considered to be 0 decibels; the same applies below) exceeds 224 decibels;

２　動作周波数が一〇キロヘルツ以上二四キロヘルツ以下であって、音圧レベルが二二四デシベルを超えるもの

ii. one with an operating frequency of 10 kilohertz or more and 24 kilohertz or less, and with the sound pressure level exceeding 224 decibels;

３　動作周波数が二四キロヘルツ超三〇キロヘルツ未満であって、音圧レベルが二三五デシベルを超えるもの

iii. one with an operating frequency of more than 24 kilohertz and less than 30 kilohertz, and with the sound pressure level exceeding 235 decibels;

４　動作周波数が一〇〇キロヘルツ未満であって、ビーム幅が一度未満の音響ビームを成形することができるもの

iv. one with an operating frequency of less than 100 kilohertz, which is capable of forming acoustic beams with the beam width of less than 1 degree;

５　一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

v. one that is designed so as to be capable of being used at water depths exceeding 1,000 meters, which falls under either of the following clauses:

一　水圧を補正することができる送受波器を有するもの

a. one that has a transducer capable of correcting water pressure;

二　チタン酸ジルコン酸鉛からなる送受信用素子以外の送受信用素子を組み込んだ送受波器を有するもの

b. one that has a transducer with built-in transmission and reception elements other than transmission and receptions elements made of lead zirconate titanate;

６　計測距離が五、一二〇メートルを超えるように設計したもの

vi. one that is designed so that its measuring distance exceeds 5,120 meters;

（三）　水中探知装置であって、送信周波数が一〇キロヘルツ未満のもの（（二）に該当するものを除く。）

3. underwater detection equipment with a transmission frequency of less than 10 kilohertz (excluding those falling under clause 2.);

（四）　音響送波器（送受波器を含む。）であって、個々に動作する圧電性物質からなる素子又は磁歪性、電歪性、電気力若しくは液圧力を有する素子を組み込んだもののうち、次のいずれかに該当するもの（音波の発生装置であって、電子

式のもの（垂直方向にのみ使用することができるものに限る。）又は機械式若しくは化学式のものを除く。）
4. among sound wave transmitters (including transducers) in which elements composed of piezoelectric materials that move individually, or elements that are magnetostrictive, electrostrictive, or that have electric force or liquid pressure, are incorporated, those which fall under any of the following clauses (excluding electronic sound wave generators (limited to those usable only in the vertical direction) or mechanical or chemical ones):
１　一〇キロヘルツ未満の周波数で使用することができるものであって、次のいずれかに該当するもの
i. those usable at frequencies of less than 10 kilohertz which fall under any of the following clauses:
一　デューティサイクルが一〇〇パーセントの状態で連続運転するように設計されていないものであって、自由音場における送波器の実効音響中心から基準距離にある主軸上の音圧レベルが次に掲げる式により算定した値を超えるもの
a. those that are not designed to continuously operate at a state in which the duty cycle is 100 percent, whose sound pressure level of the primary axis at the reference distance from the effective acoustic center of the transmitters in a free sound field exceeds the value obtained by the calculation using the following formula:
１０ｌｏｇ（ヘルツで表した一〇キロヘルツ未満の送波電圧感度が最大となる周波数）＋１６９．７７デシベル
10 log (frequency in which the wave transmission voltage sensitivity of less than 10 kilohertz expressed in hertz becomes the largest) + 169.77 decibels; or
二　デューティサイクルが一〇〇パーセントの状態で連続運転するように設計されたものであって、連続する自由音場における送波器の実効音響中心から基準距離にある主軸上の音圧レベルが次に掲げる式により算定した値を超えるもの
b. those that are designed to continuously operate at a state in which the duty cycle is 100 percent, whose sound pressure level of the primary axis at the reference distance from the effective acoustic center of the transmitters in a continuous free sound field exceeds the value obtained by the calculation using the following formula:
１０ｌｏｇ（ヘルツで表した一〇キロヘルツ未満の送波電圧感度が最大となる周波数）＋１５９．７７デシベル
10 log (frequency in which the wave transmission voltage sensitivity of less than 10 kilohertz expressed in hertz becomes the largest) + 159.77 decibels;
２　削除
ii. Deleted
３　サイドローブに対するメインローブの出力比が二二デシベルを超えるもの

iii. those for which the output ratio of the main lobe to that of the side lobe exceeds 22 decibels;

（五）　船舶用の位置決定装置であって、次の１及び２に該当するもの又はその部分品

5. equipment for determining the position of vessels, which falls under the following clauses i. and ii., or their components:

１　船舶の位置を決定するために受信する信号を発信する装置（２において「応答機」という。）を探知することができる距離が一、〇〇〇メートルを超えるもの

i. one for which the distance for detecting an equipment that transmits signals received in order to determine the position of vessels (referred to as a "transponder" in clause ii.) exceeds 1,000 meters;

２　応答機から一、〇〇〇メートル以内の距離において計測し、決定した位置の誤差の二乗平均平方根が一〇メートル未満のもの

ii. one whose root mean square of a position error measured and determined at a distance of 1,000 meters or less from the transponder is less than 10 meters;

（六）　水中において活動する人の位置を自動的に探知するために設計したソナーであって、次の１から３までの全てに該当するもののうち、音響アレーの送受信のために設計されたもの

6. among sonars designed to automatically detect the position of a person engaged in underwater activities, falling under all of the following clauses i. through iii., those designed for transmitting and receiving acoustic arrays:

１　対象を探知することができる距離が五三〇メートルを超えるもの

i. those capable of detecting the subject at a distance exceeding 530 meters;

２　当該装置から五三〇メートル以内の距離にいる人を探知した場合の位置の誤差の二乗平均平方根が一五メートル未満のもの

ii. those whose root mean square of a position error in detecting a person who is at a distance of 530 meters or less from the sonar is less than 15 meters; and

３　送信パルスの帯域幅が三キロヘルツを超えるもの

iii. those whose bandwidth of transmitted pulse exceeds 3 kilohertz;

ロ　受信機能を有するもの又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(b) one that has a receiving function, or its components, which fall under any of the following clauses:

（一）　ハイドロホンであって、加速度による影響を補正する機能を有していないもののうち、その音圧感度（一ボルト毎マイクロパスカルである場合を〇デシベルとしたときのものをいう。）がマイナス一八〇デシベルを超えるもの（水上船舶に取り付けるように設計された魚群探知機を除く。）

1. among hydrophones that do not have the function of correcting the

effects of acceleration, those with the sound pressure sensitivity (meaning the sensitivity when 1 volt per micropascal is considered to be 0 decibels) that exceeds minus 180 decibels (excluding fish-finders designed to be installed on surface vessels);

（二）　えい航ハイドロホンアレー用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関（スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。）を行うことができるもの（実時間処理できるものを除く。）

2. among signal processing equipment that is designed for towed hydrophone arrays for which users can rewrite the programs, those that can perform processing or correlation of the time domain or frequency domain (including spectrum analysis, digital filtering, or beam formation) (excluding those that can perform real-time processing);

（三）　えい航ハイドロホンアレー用に設計したヘディングセンサーであって、精度の絶対値が〇・五度未満のもののうち、三五メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの又は三五メートルを超える水深で使用することができるように調整若しくは取り外しをすることができる水深測定装置を有するもの

3. among heading sensors that are designed for towed hydrophone arrays and have an absolute accuracy value of less than 0.5 degrees, those that are designed to be usable at water depths exceeding 35 meters, or those that have a water depth measuring device that may be coordinated or detached so that they may be used at water depths exceeding 35 meters;

（四）　海底用又は港湾ケーブル用のハイドロホンアレーであって、（六）の水中音波センサーを組み込んだもの

4. hydrophone arrays for the seabed or harbor cables, which incorporate underwater sound wave sensors referred to in clause 6.;

（五）　海底用又は港湾用ケーブルシステム用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関（スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。）を行うことができるもの（実時間処理できるものを除く。）

5. among signal processing equipment that is designed for the seabed or harbor cable systems for which the user can rewrite the programs, those that can perform processing or correlation of the time domain or the frequency domain (spectrum analysis, digital filtering, or beam formation), (excluding those that can perform real-time processing);

（六）　加速度計を有する水中音波センサーであって、次の全てに該当するもの（粒子速度センサー又は地中聴音器を除く。）

6. underwater sound wave sensors with accelerometers which fall under all of the following clauses (excluding particle velocity sensors or underground listening devices):

１　三軸の加速度計により構成されるもの

i. those composed of three-axis accelerometers;

２　総加速度感度が四八デシベルを超えるもの

ii. those with a total acceleration sensitivity exceeding 48 decibels;

３　三五メートルを超える水深で動作するように設計されたもの

iii. those designed to operate at water depths exceeding 35 meters; and

４　操作周波数が二〇キロヘルツ未満のもの

iv. those with an operating frequency of less than 20 kilohertz;

二　船舶用の対地速力の測定装置（音波を利用したものに限る。）であって、次のイ又はロのいずれかに該当するもの（水上船に取り付けるように特に設計したもの又は次のハに掲げるものを除く。）

(ii) measuring equipment for the ground speed for vessels (limited to those that use sound waves), which falls under either of the following sub-item (a) or (b) (excluding one specially designed to be installed on surface vessels, or one stated in the following sub-item (c)):

イ　相関速度ログを用いたものであって、次のいずれかに該当するもの

(a) one using a correlation-velocity log, which fall under any of the following clauses:

（一）　水底から五〇〇メートルを超える位置で測定を行うことができるように設計したもの

1. one designed so that they can make a measurement at a position exceeding 500 meters from the bottom of the water;

（二）　速力の精度が速力の一パーセント未満のもの

2. one with a speed accuracy of less than 1% of the speed;

ロ　ドップラー速度ログを用いたものであって、速力の精度が速力の一パーセント未満のもの

(b) one using a Doppler velocity log, with a speed accuracy of less than 1% of the speed;

ハ　音響測深器であって、水深の測定、水底若しくは水中に存在する物体までの距離の測定又は魚群探知以外の用に供することができないもの

(c) echo sounders that may not be used for purposes other than measuring water depth, measuring the distance to underwater objects or objects buried under water, or finding schools of fish;

三　光検出器又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(iii) photodetectors or their components, which fall under any of the following sub-items:

イ　宇宙用に設計した固体の光検出器であって、次のいずれかに該当するもの

(a) solid photodetectors designed for space use which fall under any of the following clauses:

（一）　一〇ナノメートル超三〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有し、かつ、四〇〇ナノメートルを超える波長における感度が最大感度の〇・一パ

ーセント未満のもの
1. those that have a maximum sensitivity in the wavelength range exceeding 10 nanometers and 300 nanometers or less, and, for which the sensitivity at the wavelength of more than 400 nanometers is less than 0.1% of the maximum sensitivity;
（二）　九〇〇ナノメートル超一、二〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有し、かつ、応答時定数が九五ナノ秒以下のもの
2. those that have a maximum sensitivity in the wavelength range of more than 900 nanometers and 1,200 nanometers or less, and, with the response time constant of 95 nanoseconds or less;
（三）　フォーカルプレーンアレーであって、素子の数が二、〇四八を超え、かつ、三〇〇ナノメートル超九〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
3. focal plane arrays with the number of elements exceeding 2,048, and, has the maximum sensitivity in the wavelength range of more than 300 nanometers and 900 nanometers or less;
ロ　イメージ増強管であって、次の（一）又は（二）のいずれかに該当するもの（イメージングを行わない光電子増倍管であって、真空中に、単一の金属陽極又は金属陽極であって隣接する二の陽極の中心間の距離が五〇〇マイクロメートルを超えるもののみからなる電子検出素子を有するものを除く。）
(b) image reinforcing tubes that fall under either of the following clause 1. or 2. (excluding non-imaging photomultiplier tubes that have an electron sensing device consisting solely of a single metal anode or metal anodes for which the distance between the centers of two adjacent anodes exceeds 500 micrometers in the vacuum):
（一）　イメージ増強管であって、次の１から３までのすべてに該当するもの
1. imaging reinforcing tubes that fall under all of the following clauses i. through iii.:
１　四〇〇ナノメートル超一、〇五〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
i. those having a maximum sensitivity in the wavelength range of more than 400 nanometers and 1,050 nanometers or less;
２　電子イメージの増倍機能を有するものであって、次のいずれかを用いたもの
ii. those having electron image multiplication function, which use either of the following things:
一　マイクロチャンネルプレートであって、隣接する二のチャンネルの中心間の距離が一二マイクロメートル以下のもの
a. microchannel plates for which the distance between the centers of two adjacent channels is 12 micrometers or less;
二　電子検出素子であって、マイクロチャンネルプレート以外の方法で電荷増倍を行うように特に設計又は改造したもののうち、隣接する二の画素の中心間の距

離が五〇〇マイクロメートル以下のもの
b. among electron detection elements that have been specially designed or modified to achieve charge multiplication by means other than using a microchannel plate, those for which the distance between the center of two adjacent pixels is 500 micrometers or less;
３　次のいずれかに該当する光電陰極を有するもの
iii. those having a photocathode that falls under any of the following clauses:
一　主材料にマルチアルカリを用いたものであって、ルーメン感度が七〇〇マイクロアンペア毎ルーメンを超えるもの
a. those that use a multi-alkali as the main material, for which the luminous sensitivity exceeds 700 microamperes per lumen;
二　主材料に砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを用いたもの
b. those that use gallium arsenide or indium gallium arsenide as main materials;
三　主材料にＩＩＩ―Ⅴ族化合物半導体（砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを除く。）を用いたものであって最大放射感度が一〇ミリアンペア毎ワットを超えるもの
c. those that use a III-V compound semiconductor (excluding gallium arsenide or indium gallium arsenide) as the main material with a maximum radiation sensitivity exceeding 10 milliamperes per watt;
（二）　イメージ増強管であって、次の１から３のすべてに該当するもの
2. image reinforcing tubes that fall under all of the following clauses i. through iii.:
１　一、〇五〇ナノメートル超一、八〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
i. those having a maximum sensitivity in the wavelength range of more than 1,050 nanometers and 1,800 nanometers or less;
２　電子イメージの増倍機能を有するものであって、次のいずれかを用いたもの
ii. those having electron image multiplication function, which use either of the following things:
一　マイクロチャンネルプレートであって、隣接する二のチャンネルの中心間の距離が一二マイクロメートル以下のもの
a. microchannel plates for which the distance between the centers of two adjacent channels is 12 micrometers or less;
二　電子検出素子であって、マイクロチャンネルプレート以外の方法で電荷増倍を行うように特に設計又は改造したもののうち、隣接する二の画素の中心間の距離が五〇〇マイクロメートル以下のもの
b. among electron detection elements that have been specially designed or modified to achieve charge multiplication by means other than using a microchannel plate, those for which the distance between the center of two

adjacent pixels is 500 micrometers or less;

３　主材料にＩＩＩ―Ｖ族化合物半導体（砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを含む。）を用いた光電陰極又は遷移電子光電陰極であって、最大放射感度が一五ミリアンペア毎ワットを超えるものを有するもの

iii. photocathodes or transferred electron photocathodes using a III-V compound semiconductor (excluding gallium arsenide or indium gallium arsenide) as the main material, which have a maximum radiant sensitivity exceeding 15 milliamperes per watt;

ハ　イメージ増強管又はその部分品であって、次の（一）又は（二）のいずれかに該当するもの（イメージングを行わない光電子増倍管であって、真空中に、単一の金属陽極又は金属陽極であって隣接する二の陽極の中心間の距離が五〇〇マイクロメートルを超えるもののみからなる電子検出素子を有するものを除く。）

(c) image reinforcing tubes or their components, which fall under any of the following clauses 1. and 2. (excluding non-imaging photomultiplier tubes that have an electron detection element consisting solely of a single metal anode or metal anodes for which the distance between the centers of two adjacent anodes exceeds 500 micrometers in the vacuum):

（一）　イメージ増強管であって、次の１から３までのすべてに該当するもの

1. image reinforcing tubes that fall under all of the following clauses i. through iii.:

１　四〇〇ナノメートル超一、〇五〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの

i. those having a maximum sensitivity in the wavelength range of more than 400 nanometers and 1,050 nanometers or less;

２　電子イメージの増倍機能を有するものであって、次のいずれかを用いたもの

ii. those having electron image multiplication function, which use any of the following things:

一　マイクロチャンネルプレートであって、隣接する二のチャンネルの中心間の距離が一二マイクロメートル以下のもの

a. micro channel plates for which the distance between the centers of two adjacent channels is 12 micrometers or less;

二　電子検出素子であって、マイクロチャンネルプレート以外の方法で電荷増倍を行うように特に設計又は改造したもののうち、隣接する二の画素の中心間の距離が五〇〇マイクロメートル以下のもの

b. among electron detection elements that have been specially designed or modified to achieve charge multiplication by means other than using a microchannel plate, those for which the distance between the center of two adjacent pixels is 500 micrometers or less;

３　主材料にマルチアルカリを用いた光電陰極を有するものであって、当該光電陰極のルーメン感度が三五〇マイクロアンペア毎ルーメン超七〇〇マイクロアンペア毎ルーメン以下のもの

iii. those having a photocathode that uses a multi-alkali as the main material, for which the luminous sensitivity of the photocathode is more than 350 microamperes per lumen and 700 microamperes per lumen or less;

（二）　イメージ増強管の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

2. components of image reinforcing tubes which fall under any of the following things:

１　マイクロチャンネルプレートであって、隣接する二のチャンネルの中心間の距離が一二マイクロメートル以下のもの

i. micro channel plates for which the distance between the centers of two adjacent channels is 12 micrometers or less;

２　電子検出素子であって、マイクロチャンネルプレート以外の方法で電荷増倍を行うように特に設計又は改造したもののうち、隣接する二の画素の中心間の距離が五〇〇マイクロメートル以下のもの

ii. among electron detection elements that have been specially designed or modified to achieve charge multiplication by means other than by using a microchannel plate, those for which the distance between the center of two adjacent pixels is 500 micrometers or less;

３　主材料にＩＩＩ―Ｖ族化合物半導体（砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを含む。）を用いた光電陰極（四〇〇ナノメートル超一、〇五〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有する光電陰極であって最大放射感度が一〇ミリアンペア毎ワット以下のもの又は一、〇五〇ナノメートル超一、八〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有する光電陰極であって最大放射感度が一五ミリアンペア毎ワット以下のものを除く。）又は遷移電子光電陰極

iii. photocathodes using a III-V compound semiconductor (excluding gallium arsenide or indium gallium arsenide) as the main material (excluding photocathodes having a maximum sensitivity in the wavelength range of more than 400 nanometers and 1,050 nanometers or less, with a maximum radiant sensitivity of 10 milliamperes per watt or less, or photocathodes having a maximum sensitivity in the wavelength range of more than 1,050 nanometers and 1,800 nanometers or less, with a maximum radiant sensitivity of 15 milliamperes per watt or less), or transferred electron photocathodes;

ニ　宇宙用に設計していないフォーカルプレーンアレーであって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(d) focal plane arrays that are not designed for space use, which fall under the following clauses 1.and 2.:

（一）　次のいずれかに該当するもの

1. those that fall under any of the following clauses:

熱型でないフォーカルプレーンアレーであって、次のいずれかに該当するもの

focal plane arrays that are not heat-molded, which fall under any of the

following focal plane arrays:

一　要素素子が九〇〇ナノメートル超一、〇五〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するものであって、次のいずれかに該当するもの

a. those with factor elements that have the maximum sensitivity in the wavelength range of more than 900 nanometers and 1,050 nanometers or less, which fall under either of the following clauses:

イ　応答時定数が〇・五ナノ秒未満のもの

1 those with a response time constant of less than 0.5 nanoseconds; or

ロ　電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであって、最大放射感度が一〇ミリアンペア毎ワットを超えるもの

2 those specially designed or modified to achieve charge multiplication, which have the maximum radiant sensitivity of more than 10 milliamperes per watt;

二　要素素子が一、〇五〇ナノメートル超一、二〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するものであって、次のいずれかに該当するもの

b. those with factor elements that have the maximum sensitivity in the wavelength range of more than 1,050 nanometers and 1,200 nanometers or less, which fall under either of the following clauses:

イ　応答時定数が九五ナノ秒以下のもの

1 those with a response time constant of 95 nanoseconds or less;

ロ　電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであって、最大放射感度が一〇ミリアンペア毎ワットを超えるもの

2 those specially designed or modified to achieve charge multiplication, which have the maximum radiant sensitivity exceeding 10 milliamperes per watt;

三　要素素子を二次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が一、二〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの

c. those in which the factor elements are arrayed in two dimensions and each factor element has the maximum sensitivity in the wavelength range of more than 1,200 nanometers and 30,000 nanometers or less;

四　要素素子を一次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が一、二〇〇ナノメートル超三、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの（ゲルマニウムのみを用いた要素素子を有するものであって、要素素子の数が三二以下のものを除く。）

d. among those in which the factor elements are arrayed in one dimension and each factor element has the maximum sensitivity in the wavelength range of more than 1,200 nanometers and 3,000 nanometers or less, those that fall under any of the following clauses (excluding those that have factor elements using only germanium, with the number of factor elements that is 32 or less):

イ　要素素子の配列方向を基準とする要素素子の縦横比が三・八未満のもの
1 those for which the aspect ratio of the factor elements using the array direction of the factor elements as the standard is less than 3.8;
ロ　同一要素素子内に時間遅延及び積分機能を有するもの
2 those that have a time delay and integrating function within the same factor element;

五　要素素子を一次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が三、〇〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの

e. those in which the factor elements are arrayed in one dimension and each factor elements has the maximum sensitivity in the wavelength range of more than 2,500 nanometers and 30,000 nanometers or less;

六　要素素子が四〇〇ナノメートル超九〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するものであって、次のイ及びロに該当するもの

f. those in which factor elements have the maximum sensitivity in the wavelength range of more than 400 nanometers and 900 nanometers or less, which fall under the following clauses 1 and 2:

イ　電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであって、七六〇ナノメートルを超える波長における最大放射感度が一〇ミリアンペア毎ワットを超えるもの
1 those specially designed or modified to achieve charge multiplication, which have the maximum radiant sensitivity exceeding 10 milliamperes per watt at a wavelength exceeding 760 nanometers;
ロ　要素素子の数が三二を超えるもの
2 those with the number of factor elements exceeding 32;

２　要素素子を二次元に配列した赤外線熱型フォーカルプレーンアレーであって、それぞれの要素素子がフィルターのない状態において八、〇〇〇ナノメートル以上一四、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で感度を有するもの

ii. infrared thermal type focal plane arrays in which the factor elements are arrayed in two dimensions and each factor element has a sensitivity in the wavelength range of 8,000 nanometers or more and 14,000 nanometers or less in an unfiltered state;

（二）　次のいずれかに該当するもの

2. those that fall under any of the following clauses:

１　白金シリコンを用いたものであって、要素素子の数が一〇、〇〇〇未満のもの

i. those that use platinum silicon, with less than 10,000 factor elements;

２　イリジウムシリコンを用いたもの

ii. those that use iridium silicon;

３　アンチモン化インジウム又はセレン化鉛を用いたものであって、要素素子の数が二五六未満のもの

iii. those that use indium antimonide or lead selenide, with less than 256

factor elements;
４　砒化インジウムを用いたもの
iv. those that use indium arsenide;
５　硫化鉛を用いたもの
v. those that use lead sulfide;
６　砒化インジウムガリウムを用いたもの
vi. those that use indium gallium arsenide; or
７　テルル化水銀カドミウムを用いたスキャニングアレーであって、次のいずれかに該当するもの
vii. scanning arrays that use mercury cadmium telluride, which fall under any of the following clauses:
一　同一検出要素素子内に時間遅延及び積分機能を有していないものであって、要素素子の数が三〇以下のもの
a. those that do not have a time delay and integrating function in the same detection factor element, with the number of factor elements of 30 or less;
二　同一検出要素素子内に時間遅延及び積分機能を有するものであって、要素素子の数が二以下のもの
b. those that have a time delay and integrating function in the same detection factor element, with the number of factor elements of two or less;
８　テルル化水銀カドミウムを用いたステアリングアレーであって、要素素子の数が二五六未満のもの
viii. steering arrays that use mercury cadmium telluride, with the number of factor elements of less than 256;
９　砒化ガリウム又は砒化アルミニウムガリウムを用いた量子井戸フォーカルプレーンアレーであって、要素素子の数が二五六未満のもの
ix. quantum well focal plane arrays that use gallium arsenide or aluminum gallium arsenide, with the number of factor elements of less than 256;
１０　熱型フォーカルプレーンアレーであって、要素素子の数が八、〇〇〇未満のもの
x. thermal type focal plane arrays, with the number of factor elements of less than 8,000;
１１　要素素子を一次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が四〇〇ナノメートル超九〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもののうち、要素素子の数が四、〇九六以下のもの
xi. among focal plane arrays in which the factor elements are arrayed in one dimension and each factor element has the maximum sensitivity in the wavelength range of more than 400 nanometers and 900 nanometers or less, those with the number of factor elements of 4,096 or less;
１２　要素素子を二次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が四〇〇ナノメートル超九〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもののうち、一方向の最大の要素素子の数が四、〇九六以下であり、かつ、すべての要素

素子の数が二五〇、〇〇〇以下のもの

xii. focal plane arrays in which the factor elements are arrayed in two dimensions and each factor element has the maximum sensitivity in the wavelength range of more than 400 nanometers and 900 nanometers or less, those whose maximum number of unidirectional factor elements are 4,096 or less, and, the number of all of the factor elements are 250,000 or less;

ホ　宇宙用に設計していないフォーカルプレーンアレーであって、次のいずれかに該当するもののうち、ニに該当するもの以外のもの

(e) among focal plane arrays that are not designed for space use which fall under any of the following clauses, those other than the ones that fall under clause (d):

（一）　熱型でないフォーカルプレーンアレーであって、次のいずれかに該当するもの

1. focal plane arrays that are not thermal type, which fall under any of the following clauses:

１　要素素子が九〇〇ナノメートル超一、〇五〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するものであって、次のいずれかに該当するもの

i. those in which the factor elements have the maximum sensitivity in the wavelength range of more than 900 nanometers and 1,050 nanometers or less, which fall under any of the following clauses:

一　応答時定数が〇・五ナノ秒未満のもの

a. those with a response time constant of less than 0.5 nanoseconds;

二　電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであって、最大放射感度が一〇ミリアンペア毎ワットを超えるもの

b. those specially designed or modified to achieve charge multiplication, which have a maximum radiant sensitivity exceeding 10 milliamperes per watt;

２　要素素子が一、〇五〇ナノメートル超一、二〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するものであって、次のいずれかに該当するもの

ii. those in which the factor elements have the maximum sensitivity in the wavelength range of more than 1,050 nanometers and 1,200 nanometers or less, which fall under either of the following clauses:

一　応答時定数が九五ナノ秒以下のもの

a. those with a response time constant of 95 nanoseconds or less;

二　電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであって、最大放射感度が一〇ミリアンペア毎ワットを超えるもの

b. those specially designed or modified to achieve charge multiplication, which have a maximum radiant sensitivity exceeding 10 milliamperes per watt;

３　要素素子を二次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が一、二〇

〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
iii. those in which the factor elements are arrayed in two dimensions and each factor element has the maximum sensitivity in the wavelength range of more than 1,200 nanometers and 30,000 nanometers or less;
４　要素素子を一次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が一、二〇〇ナノメートル超三、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの（ゲルマニウムのみを用いた要素素子を有するものであって、要素素子の数が三二以下のものを除く。）
iv. among those in which the factor elements are arrayed in one dimension and each factor element has the maximum sensitivity in the wavelength range of more than 1,200 nanometers and 3,000 nanometers or less, those which fall under either of the following clauses (excluding those that have factor elements using only germanium, with the number of factor elements of 32 or less):
一　要素素子の配列方向を基準とする要素素子の縦横比が三・八未満のもの
a. those for which the aspect ratio of the factor elements using the array direction of the factor elements as the standard, is less than 3.8;
二　同一要素素子内に時間遅延及び積分機能を有するもの
b. those having a time delay and integrating function in the same factor element;
５　要素素子を一次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が三、〇〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの
v. those in which the factor elements are arrayed in one dimension and each factor element has the maximum sensitivity in the wavelength range of more than 2,500 nanometers and 30,000 nanometers or less;
６　要素素子が四〇〇ナノメートル超九〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するものであって、次の一及び二に該当するもの
vi. those in which the factor elements have the maximum sensitivity in the wavelength range of more than 400 nanometers and 900 nanometers or less, which fall under the following clauses a. and b.:
一　電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであって、七六〇ナノメートルを超える波長における最大放射感度が一〇ミリアンペア毎ワットを超えるもの
a. those specially designed or modified to achieve charge multiplication, which have a maximum radiant sensitivity exceeding 10 milliamperes per watt at the wavelength exceeding 760 nanometers;
二　要素素子の数が三二を超えるもの
b. those with the number of factor elements that exceeds 32;
（二）　要素素子を二次元に配列した赤外線熱型フォーカルプレーンアレーであ

って、それぞれの要素素子がフィルターのない状態において八、〇〇〇ナノメートル以上一四、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で感度を有するもの

2. infrared thermal type focal plane arrays in which the factor elements are arrayed in two dimensions and each factor element has a sensitivity in the wavelength range of more than 8,000 nanometers and 14,000 nanometers or less in an unfiltered state;

四　リモートセンシング用に設計したモノスペクトルイメージセンサー又はマルチスペクトルイメージセンサーであって、次のいずれかに該当するもの

(iv) mono-spectrum image sensors or multi-spectrum image sensors that are designed for remote sensing, which fall under any of the following sub-items:

イ　瞬時視野が二〇〇マイクロラジアン未満のもの

(a) those with an instantaneous field of view of less than 200 microradians;

ロ　四〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、イメージデータをデジタル形式で出力するもののうち、次のいずれかに該当するもの

(b) among those that are designed for use within the wavelength range of more than 400 nanometers and 30,000 nanometers or less, which output image data digitally, those which fall under any of the following clauses:

（一）　宇宙用に設計したもの

1. those that are designed for space use;

（二）　航空機搭載用に設計したものであって、シリコンを用いた検出器以外の検出器を用いたもののうち、瞬時視野が二・五ミリラジアン未満のもの

2. among those that are designed to be installed in aircraft and use detectors other than silicon detectors, those with an instantaneous field of view of less than 2.5 milliradians;

五　光検出器を用いた装置であって、直視型のもののうち、次のいずれかに該当するもの（医療用装置であって、主材料に砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを用いた光電陰極を組み込んでいないものを除く。）

(v) among devices that use photodetectors and that are direct-view type, those which fall under any of the following clauses (excluding medical equipment that do not have photocathodes using gallium arsenide or indium gallium arsenide as the main material incorporated):

イ　次のいずれかに該当する光検出器を組み込んだもの

(a) those that incorporate photodetectors that fall under any of the following clauses:

（一）　第三号ロに該当するイメージ増強管

1. image reinforcing tubes that fall under item (iii), sub-item (b);

（二）　第三号ホに該当するフォーカルプレーンアレー

2. focal plane arrays that fall under item (iii), sub-item (e); or

（三）　第三号イ又は第十四条第七号に該当する固体の光検出器

3. solid photodetectors that fall under item (iii), sub-item (a) or Article 14,

item (vii);

ロ　次のいずれかに該当する光検出器を組み込んだもの（イに該当するものを除く。）

(b) those that have photodetectors that fall under any of the following things incorporated (excluding those that fall under sub-item (a)):

（一）　第三号ハ（一）に該当するイメージ増強管

1. image reinforcing tubes that fall under item (iii), sub-item (c), 1.;

（二）　第三号ニに該当するフォーカルプレーンアレー

2. focal plane arrays that fall under item (iii), sub-item (d);

六　光検出器用の冷却器であって、次のいずれかに該当するもの

(vi) coolers for photodetectors which fall under any of the following sub-items:

イ　宇宙用に設計したもの

(a) those designed for space use;

ロ　宇宙用に設計していないものであって、冷却のための接触面の温度が零下五五度未満のもののうち、次のいずれかに該当するもの

(b) among those that are not designed for space use, with the temperature of the contact surface used for cooling of under minus 55 degrees centigrade, those which fall under any of the following clauses:

（一）　循環式のものであって、平均故障寿命又は平均故障間隔が二、五〇〇時間を超えるもの

1. those that are circulation type with the average breakdown life or average breakdown interval exceeding 2,500 hours;

（二）　ジュールトムソン自己制御冷却器であって、直径が八ミリメートル未満のもの

2. self-regulated Joule-Thomson coolers with a diameter of less than 8 millimeters;

七　センサー用の光ファイバーであって、音響、温度、加速度、電磁気又は放射線の測定用のもの

(vii) optical fibers for sensors which are used to measure sounds, temperature, acceleration, electromagnetism, or radiation;

七の二　第三号ニ又はホのいずれかに該当するフォーカルプレーンアレーのために特に設計した読み出し集積回路（民生用の自動車のために特に設計したものを除く。）

(vii)-2 readout integrated circuits that are specially designed for focal plane arrays that fall under either item (iii), clause (d) or (e) (excluding those specially designed for automobiles for civilian use);

八　電子式のカメラ又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(viii) electronic cameras or their components, which fall under any of the following sub-items:

イ　次のいずれかに該当するもの

(a) those that fall under any of the following clauses:

（一）　第三号ロに該当するイメージ増強管を組み込んだものであって、次のいずれかに該当するもの

1. those with built-in image reinforcing tubes that fall under item (iii), sub-item (b), which fall under either of the following cameras:

１　水中用に設計していないもの

i. those that are not designed for underwater use; or

２　水中用に設計したもの

ii. those that are designed for underwater use;

（二）　第三号ホに該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだものであって、次のいずれかに該当するもの

2. those with built-in focal plane arrays that fall under item (iii), sub-item (e), which fall under either of the following clauses:

１　水中用に設計していないもの

i. those that are not designed for underwater use; or

２　水中用に設計したもの

ii. those that are designed for underwater use;

（三）　第三号イ又は第十四条第七号に該当する固体の光検出器を組み込んだもの

3. those with solid photodetectors that fall under item (iii), sub-item (a) or Article 14, item (vii) incorporated;

ロ　次のいずれかに該当するもの（イに該当するものを除く。）

(b) those that fall under any of the following cameras (excluding those that fall under sub-item (a)):

（一）　削除

1. Deleted

（二）　削除

2. Deleted

（三）　電子式のストリークカメラであって、時間分解能が五〇ナノ秒未満のもの

3. electronic streak cameras with a time resolution of less than 50 nanoseconds;

（四）　電子式のフレーミングカメラであって、撮影速度が一秒につき一、〇〇〇、〇〇〇こまを超えるもの

4. electronic framing cameras with a shooting speed of more than 1 million frames per second;

（五）　電子式のカメラであって、次の１及び２に該当するもの

5. electronic cameras that fall under the following clauses i. and ii.:

１　シャッター速度が一マイクロ秒未満のもの

i.those with a shutter speed of less than 1 microsecond; and

２　信号の読出速度が一秒につき一二五こまを超えるもの

ii. those with a signal readout speed of more than 125 frames per second;

（六）　モジュール式の構造を有する電子式のカメラ（（三）から（五）までに該当するものに限る。）のために特に設計したプラグインユニットであって、（三）から（五）までのいずれかに該当するものが有する機能に到達させることができるもの
6. plug-in units that are specially designed for electronic cameras having a module- type structure (limited to those falling under clauses 3. through 5.), which are capable of making those cameras reach the functionality of the cameras that fall under any of the clauses 3. through 5.;
（七）　固体撮像素子を組み込んだビデオカメラであって、一〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもののうち、次の１から３までのいずれかに該当し、かつ、４から６までのいずれかに該当するもの
7. among video cameras that have solid-state image sensors incorporated which have the maximum sensitivity in the wavelength range of more than 10 nanometers and 30,000 nanometers or less, those which fall under any of the following clauses i. through iii., and, also fall under any of the following clauses iv. through vi.:
１　白黒撮影用のものであって、固体撮像素子の有効画素数が四、〇〇〇、〇〇〇を超えるもの
i. those for black and white photography for which the number of effective pixels of the solid-state image sensor is more than 4,000,000;
２　三の固体撮像素子を組み込んだカラー撮影用のものであって、それぞれの固体撮像素子の有効画素数が四、〇〇〇、〇〇〇を超えるもの
ii. those for color photography that have three solid-state image sensors incorporated, for which the number of effective pixels of each solid-state image sensor is more than 4,000,000;
３　一の固体撮像素子を組み込んだカラー撮影用のものであって、当該固体撮像素子の有効画素数が一二、〇〇〇、〇〇〇を超えるもの
iii. those for color photography that have one solid-state image sensor incorporated, for which the number of effective pixels of the solid-state image sensor is more than 12,000,000;
４　第九号イに該当する反射鏡を有するもの
iv. those having a reflector that falls under item (ix), sub-item (a);
５　第九号ニに該当する光学器械又は光学部品の制御装置を有するもの
v. those having a control device of the optical device or optical components that fall under item (ix), sub-item (d); or
６　カメラの被写体追跡データを内部処理して画像情報に注記できる機能を有するもの
vi. those having a function that can internally process tracking data for the subject of photography and make an entry of the data in the image information;

（八）　スキャニングカメラ又はスキャニングカメラ装置であって、次の１から３までのすべてに該当するもの

8. scanning cameras or scanning camera equipment that fall under all of the following clauses i. through iii.:

１　一〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの

i. those having a maximum sensitivity in the wavelength range of more than 10 nanometers and 30,000 nanometers or less;

２　画素が線状に並んだ固体撮像素子を組み込んだものであって、当該画素の数が、八、一九二を超えるもの

ii. those that have solid-state image sensor in which the pixels are arrayed in a linear fashion incorporated and the number of pixels exceeds 8,192;

３　一方向に機械的に走査を行うもの

iii. those that scan mechanically in one direction;

（九）　第三号ハ（一）に該当するイメージ増強管を組み込んだもの

9. scanning cameras or scanning camera equipment that has an image reinforcing tube that falls under item (iii), sub-item (c), 1. incorporated;

（十）　第三号ニに該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだもの

10. scanning cameras or scanning camera equipment that has a focal plane array that falls under item (iii), sub-item (d) incorporated;

九　光学器械又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(ix) optical equipment or their components which fall under any of the following:

イ　反射鏡であって、次のいずれかに該当するもの

(a) reflectors which fall under any of the following clauses:

（一）　鏡面の形状を変化させることができるものであって、能動開口の口径が一〇ミリメートルを超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの又はその部分品

1. among those that are capable of altering the shape of the mirror surface and whose active aperture has a diameter exceeding 10 millimeters, those that fall under any of the following reflectors or their components:

１　機器の共振周波数が七五〇ヘルツ以上であって、二〇〇個を超える作動器を有するもの

i. those for which the resonance frequency of the machinery and tools is 750 hertz or more, which have more than 200 actuating devices; or

２　レーザー損傷閾値が次のいずれかに該当するもの

ii. those for which the laser damage threshold falls under either of the following clauses:

一　持続波レーザー発振器を使用した場合に一平方センチメートル当たり一キロワットを超えるもの

a. those for which the laser damage threshold exceeds 1 kilowatt per

square centimeter when a continuous-wave laser oscillator is used; or
二　パルス繰り返し周波数が二〇ヘルツで、パルス幅が二〇ナノ秒のレーザーパルスを使用した場合に一平方センチメートル当たり二ジュールを超えるもの
b. those for which the laser damage threshold exceeds 2 joules per square centimeter when a laser pulse with a pulse repetition frequency of 20 hertz and a pulse width of 20 nanoseconds is used;
（二）　複合材料又は発泡体の部分を有していないものであって、鏡面の一平方メートル当たりの質量が三〇キログラム未満のもののうち、全重量が一〇キログラムを超えるもの（太陽放射を追従するために地上に設置されたヘリオスタット用に設計した反射鏡を除く。）
2. among reflectors that do not have parts made of composite materials or foams, in which the mirror surface has a mass per square meter of less than 30 kilograms, those whose total weight exceeds 10 kilograms (excluding reflectors that are designed for heliostats set up on the ground to follow solar radiation);
（三）　複合材料又は発泡体の部分を有するものであって、鏡面の一平方メートル当たりの質量が三〇キログラム未満のもののうち、全重量が二キログラムを超えるもの（太陽放射を追従するために地上に設置されたヘリオスタット用に設計した反射鏡を除く。）
3. among reflectors that have parts made of composite materials or foams, in which the mirror surface has a mass per square meter of less than 30 kilograms, those whose total weight exceeds 2 kilograms (excluding reflectors that are designed for heliostats set up on the ground to follow solar radiation);
（四）　ニ（二）１に該当する光の走査用の反射鏡ステージのために設計された反射鏡であって、平面度が六三・三ナノメートル以下のもののうち、次のいずれかに該当するもの
4. among reflectors that are designed for reflector stages for scanning light falling under sub-item (d), clause 2., i., whose flatness is 63.3 nanometers or less, those which fall under any of the following clauses:
１　直径又は長軸の長さが一〇〇ミリメートル以上のもの
i. those whose diameter or length of the long axis is 100 millimeters or more; or
２　次の一及び二に該当するもの
ii. those which fall under the following clauses a. and b.:
一　直径又は長軸の長さが五〇ミリメートル超一〇〇ミリメートル未満のもの
a. those whose diameter or length of the long axis is more than 50 millimeters and less than 100 millimeters; and
二　レーザー損傷閾値が次のいずれかに該当するもの
b. those for which the laser damage threshold falls under any of the following clauses:

イ　持続波レーザー発振器を使用した場合に一平方センチメートル当たり一〇キロワットを超えるもの

1 those for which the laser damage threshold exceeds 10 kilowatts per square centimeter when a continuous-wave laser oscillator is used; or

ロ　パルス繰り返し周波数が二〇ヘルツで、パルス幅が二〇ナノ秒のレーザーパルスを使用した場合に一平方センチメートル当たり二〇ジュールを超えるもの

2 those for which the laser damage threshold exceeds 20 joules per square centimeter, when a laser pulse with a pulse repetition frequency of 20 hertz and a pulse width of 20 nanoseconds is used;

ロ　セレン化亜鉛又は硫化亜鉛からなる光学部品であって、三、〇〇〇ナノメートル超二五、〇〇〇ナノメートル以下の波長の光を透過するもののうち、次のいずれかに該当するもの

(b) among optical components composed of zinc selenide or zinc sulfide, which transmits light with a wavelength of more than 3,000 nanometers and 25,000 nanometers or less, those which fall under either of the following cluases:

（一）　体積が一〇〇立方センチメートルを超えるもの

1.those with a volume exceeding 100 cubic centimeters;

（二）　直径又は長軸の長さが八〇ミリメートルを超え、かつ、厚さが二〇ミリメートルを超えるもの

2. those with the diameter or the length of long axis exceeding 80 millimeters, and, the thickness exceeding 20 millimeters;

ハ　宇宙用に設計した光学部品であって、次のいずれかに該当するもの

(c) optical components that are designed for use in space, which fall under any of the following clauses:

（一）　全体が稠密な状態である場合に比し二〇パーセント未満の重量に軽量化したもの

1. those whose weight has been reduced to a weight of less than 20% compared to the weight when the whole component has a dense state;

（二）　基板（コーティングしたもの又は保護膜を有するものを含む。）

2. substrates (including those that are coated or have a protective film);

（三）　宇宙空間で組み立てるように設計した反射鏡であって、組み立てた場合の受光面積の和が口径一メートル以上の反射鏡と同等になるものの部分品

3. reflectors that are designed to be assembled in space, with the total of the light receiving areas when assembled is equivalent to that for a reflector with an aperture that is greater than 1 meter;

（四）　すべての方向について線膨張係数が温度一度当たり一〇〇万分の五以下の複合材料からなるもの

4. those composed of composite materials whose linear coefficient of expansion in all directions is 5/1,000,000 or less per degree of temperature;

ニ　光学器械又は光学部品の制御装置であって、次のいずれかに該当するもの

(d) control devices for an optical device or optical components, which fall under any of the following clauses:

（一）　ハ（一）又は（三）に該当する宇宙用に設計した光学部品の表面形状又は方向を維持するように設計したもの

1. those that are designed to maintain the surface shape or direction of optical components having been designed for space use which fall under sub-item (c), clause 1. or 3.;

（二）　光の走査、追尾若しくは安定化又は光共振器の調整を行うものであって、次のいずれかに該当するもの

2. those for scanning, tracking, or stabilizing light, or adjusting optical resonators, which fall under any of the following clauses:

１　直径又は長軸の長さが五〇ミリメートルを超える反射鏡を支えるように設計された光の走査用の反射鏡ステージであって、次の一から三までの全てに該当するもの又はそのために設計した電子制御装置

i. reflector stages for scanning light which are designed to support a reflector whose diameter or length of the long axis exceeds 50 millimeters, which fall under all of the following clauses a. through c., or electronic control device designed for them:

一　最大移動角距離がプラスマイナス二六ミリラジアン以上のもの

a. those whose maximum angular travel is plus or minus 26 milliradians or more;

二　機器の共振周波数が五〇〇ヘルツ以上のもの

b. those for which the resonance frequency of the machine is 500 hertz or more; and

三　角精度が一〇マイクロラジアン以下のもの

c. those whose angular accuracy is 10 microradians or less;

２　光共振器の調整を行う装置であって、一〇〇ヘルツ以上の帯域幅及び一〇マイクロラジアン以下の精度を有するもの

ii. devices that adjust optical resonators with a bandwidth of 100 hertz or more and accuracy of 10 microradians or less;

（三）　最大振れ角が五度を超え、かつ、一〇〇ヘルツ以上の帯域幅で使用することができるジンバルであって、次のいずれかに該当するもの

3. gimbals with a maximum deflection angle exceeding 5 degrees, and, can be used in bandwidths of 100 hertz or more, which fall under either of the following clauses:

１　直径又は長軸の長さが〇・一五メートル超一メートル以下のものであって、角加速度が二ラジアン毎秒毎秒を超え、かつ、精度が二〇〇マイクロラジアン以下のもの

i. those with a diameter or length of the long axis of more than 0.15 meters and 1 meter or less, with an angular acceleration exceeding 2 radians per second squared, and, with an accuracy of 200 microradians or less; or

２　直径又は長軸の長さが一メートルを超えるものであって、角加速度が〇・五ラジアン毎秒毎秒を超え、かつ、精度が二〇〇マイクロラジアン以下のもの

ii. those with a diameter or length of the long axis exceeding 1 meter, with an angular acceleration exceeding 0.5 radians per second squared, and, with an accuracy of 200 microradians or less;

九の二　非球面光学素子であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの

(ix)-2 aspheric optical elements that fall under all of the following sub-items (a) through (c):

イ　光学的開口の最大寸法が四〇〇ミリメートルを超えるもの

(a) those with the maximum measurement for the optical aperture exceeding 400 millimeters;

ロ　一ミリメートル以上のサンプリング長さにおける表面粗さの二乗平均が一ナノメートル未満のもの

(b) those that have a root mean square of the surface roughness at the sampling length of 1 millimeter or more of less than 1 nanometer; and

ハ　摂氏二五度の温度における線膨張係数の絶対値が一〇〇万分の三未満のもの

(c) those for which the absolute value of the linear coefficient of expansion at a temperature of 25 degrees centigrade is less than 3/1,000,000;

九の三　波面測定装置であって、次のイ及びロに該当するもの

(ix)-3 wavefront measuring devices that fall under the following sub-items (a) and (b):

イ　フレーム速度が一キロヘルツ以上のもの

(a) those whose frame speed is 1 kilohertz or more; and

ロ　波面精度が設計された波長において二〇分の一以下のもの

(b) those with a wavefront accuracy of one-twentieth or less at a designed wavelength;

十　レーザー発振器又はその部分品、附属品若しくは試験装置であって、次のいずれかに該当するもの

(x) laser oscillators, or their components, accessories or testing devices, which fall under any of the following sub-items:

イ　波長可変レーザー発振器以外の持続波レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの（ニに該当するものを除く。）

(a) continuous wave laser oscillators other than variable wavelength laser oscillators, which fall under any of the following clauses (excluding those falling under sub-item (d)):

（一）　一五〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、定格出力が一ワットを超えるもの

1. those designed to be used in the wavelength range of less than 150 nanometers, whose rated output exceeds 1 watt;

（二）　一五〇ナノメートル以上五一〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、定格出力が三〇ワットを超えるもの（アルゴンレ

ーザー発振器であって定格出力が五〇ワット以下のものを除く。）
2. those designed to be used in the wavelength range of 150 nanometers or more and 510 nanometers or less, whose rated output exceeds 30 watts (excluding argon laser oscillators whose rated output is 50 watts or less);
（三）　五一〇ナノメートル超五四〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
3. those designed to be used in the wavelength range of more than 510 nanometers and 540 nanometers or less, which fall under either of the following clauses:
１　単一横モードで発振するものであって、定格出力が五〇ワットを超えるもの
i. those that oscillate in a single transverse mode whose rated output exceeds 50 watts; or
２　多重横モードで発振するものであって、定格出力が一五〇ワットを超えるもの
ii. those that oscillate in a multiple transverse mode whose rated output exceeds 150 watts;
（四）　五四〇ナノメートル超八〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、定格出力が三〇ワットを超えるもの
4. those designed to be used in the wavelength range of more than 540 nanometers and 800 nanometers or less, whose rated output exceeds 30 watts;
（五）　八〇〇ナノメートル超九七五ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
5. those designed to be used in the wavelength range of more than 800 nanometers and 975 nanometers or less, which fall under either of the following clauses:
１　単一横モードで発振するものであって、定格出力が五〇ワットを超えるもの
i. those that oscillate in a single transverse mode whose rated output exceeds 50 watts; or
２　多重横モードで発振するものであって、定格出力が八〇ワットを超えるもの
ii. those that oscillate in a multiple transverse modewhose rated output exceeds 80 watts;
（六）　九七五ナノメートル超一、一五〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
6. those designed to be used in the wavelength range of more than 975 nanometers and 1,150 nanometers or less, which fall under either of the following clauses:
１　単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
i. those that oscillate in a single transverse mode which fall under either of the following clauses:
一　定格出力が一、〇〇〇ワットを超えるもの

a. those whose rated output exceeds 1,000 watts;
二　次のイ及びロに該当するもの
b. those that fall under the following clauses 1 and 2:
イ　定格出力が五〇〇ワットを超えるもの
1 those whose rated output exceeds 500 watts;
ロ　スペクトルバンド幅が四〇ギガヘルツ未満のもの
2 those with a spectral bandwidth of less than 40 gigahertz;
２　多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの（産業用レーザー発振器であって、定格出力が二キロワット超六キロワット以下のもののうち、総重量が一、二〇〇キログラムを超えるものを除く。）
ii. those that oscillate in a multiple transverse mode which fall under either of the following clauses (excluding industrial laser oscillators whose rated output exceeds 2 kilowatts and 6 kilowatts or less with a gross mass of greater than 1,200 kilograms):
一　ウォールプラグ効率が一八パーセントを超えるものであって、定格出力が一、〇〇〇ワットを超えるもの
a. those with a wall-plug efficiency exceeding 18%, whose rated output exceeds 1,000 watts; or
二　定格出力が二キロワットを超えるもの
b. those whose rated output exceeds 2 kilowatts;
（七）　一、一五〇ナノメートル超一、五五五ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
7. those that are designed to be used in the wavelength range of more than 1,150 nanometers and 1,555 nanometers or less, which fall under either of the following clauses:
１　単一横モードで発振するものであって、定格出力が五〇ワットを超えるもの
i. those that oscillate in a single transverse mode whose rated output exceeds 50 watts;
２　多重横モードで発振するものであって、定格出力が八〇ワットを超えるもの
ii. those that oscillate in a multiple transverse mode whose rated output exceeds 80 watts;
（八）　一、五五五ナノメートル超一、八五〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、定格出力が一ワットを超えるもの
8. those that are designed to be used in the wavelength range of more than 1,555 nanometers and 1,850 nanometers or less whose rated output exceeds 1 watt;
（九）　一、八五〇ナノメートル超二、一〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
9. those that are designed to be used in the wavelength range of more than 1,850 nanometers and 2,100 nanometers or less, which fall under either of the following clauses:

１　単一横モードで発振するものであって、定格出力が一ワットを超えるもの
i. those that oscillate in a single transverse mode whose rated output exceeds 1 watt; or
２　多重横モードで発振するものであって、定格出力が一二〇ワットを超えるもの
ii. those that oscillate in a multiple transverse mode whose rated output exceeds 120 watts;
（十）　二、一〇〇ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したものであって、定格出力が一ワットを超えるもの
10. those that are designed to be used in the wavelength range of more than 2,100 nanometers whose rated output exceeds 1 watt;
ロ　波長可変レーザー発振器以外のパルスレーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの（ニに該当するものを除く。）
(b) continuous wave laser oscillators other than variable wavelength laser oscillators, which fall under any of the following clauses (excluding those falling under sub-item (d)):
（一）　一五〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1. those designed to be used in the wavelength range of less than 150 nanometers, which fall under either of the following clauses:
１　一パルス当たり五〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が一ワットを超えるもの
i. those that oscillate pulses exceeding 50 millijoules per pulse, and, whose peak output exceeds 1 watt; or
２　平均出力が一ワットを超えるもの
ii. those with an average output exceeding 1 watt;
（二）　一五〇ナノメートル以上五一〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
2. those designed to be used in the wavelength range of more than 150 nanometers and 510 nanometers or less, which fall under either of the following clauses:
１　一パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が三〇ワットを超えるもの
i. those that oscillate pulses exceeding 1.5 joules per pulse, and, whose peak output exceeds 30 watts; or
２　平均出力が三〇ワットを超えるもの（アルゴンレーザー発振器であって、平均出力が五〇ワット以下のものを除く。）
ii. those with an average output exceeding 30 watts (excluding argon laser oscillators with an average output of 50 watts or less);
（三）　五一〇ナノメートル超五四〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

3. those that are designed to be used in the wavelength range of more than 510 nanometers and 540 nanometers or less, which fall under any of the following:
１　単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
i. those that oscillate in a single transverse mode which fall under either of the following clauses:
一　一パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が五〇ワットを超えるもの
a. those that oscillate pulses exceeding 1.5 joules per pulse, and, whose peak output exceeds 50 watts; or
二　平均出力が五〇ワットを超えるもの
b. those with an average output that exceeds 50 watts;
２　多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
ii. those that oscillate in a multiple transverse mode and fall under either of the following clauses:
一　一パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が一五〇ワットを超えるもの
a. those that oscillate pulses exceeding 1.5 joules per pulse, and, whose peak output exceeds 150 watts; or
二　平均出力が一五〇ワットを超えるもの
b. those with an average output exceeding 150 watts;
（四）　五四〇ナノメートル超八〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
4. those designed to be used in the wavelength range of more than 540 nanometers and 800 nanometers or less, which fall under either of the following clauses:
１　一ピコ秒未満のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
i. those that oscillate pulses with a pulse width of less than 1 picosecond which fall under either of the following clauses:
一　一パルス当たり〇・〇〇五ジュールを超えるパルスを発振するものであって、ピーク出力が五ギガワットを超えるもの
a. those that oscillate pulses exceeding 0.005 joules per pulse whose peak output exceeds 5 gigawatts; or
二　平均出力が二〇ワットを超えるもの
b. those with an average output exceeding 20 watts;
２　一ピコ秒以上のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
ii. those that oscillate pulses with a pulse width of 1 picosecond or more which fall under either of the following clauses:
一　一パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振するものであって、ピ

ーク出力が三〇ワットを超えるもの
a. those that oscillate pulses exceeding 1.5 joules per pulse whose peak output exceeds 30 watts; or
二　平均出力が三〇ワットを超えるもの
b. those with an average output exceeding 30 watts;
（五）　八〇〇ナノメートル超九七五ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
5. those that are designed to be used in the wavelength range of more than 800 nanometers and 975 nanometers or less, which fall under any of the following clauses:
１　一ピコ秒未満のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
i. those that oscillate pulses with a pulse width of 1 picosecond or less, which fall under either of the following clauses:
一　一パルス当たり〇・〇〇五ジュールを超えるパルスを発振するものであって、ピーク出力が五ギガワットを超えるもの
a. those that oscillate pulses exceeding 0.005 joules per pulse whose peak output exceeds 5 gigawatts;
二　単一横モードで発振するものであって、平均出力が二〇ワットを超えるもの
b. those that oscillate in a single transverse mode with an average output exceeding 20 watts;
２　一ピコ秒以上一マイクロ秒以下のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
ii. those that oscillate pulses with a pulse width of 1 picosecond or more and 1 microsecond or less, which fall under any of the following clauses:
一　一パルス当たり〇・五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が五〇ワットを超えるもの
a. those that oscillate pulses exceeding 0.5 joules per pulse, and, whose peak output exceeds 50 watts;
二　単一横モードで発振するものであって、平均出力が二〇ワットを超えるもの
b. those that oscillate in a single transverse mode with an average output exceeding 20 watts;
三　多重横モードで発振するものであって、平均出力が五〇ワットを超えるもの
c. those that oscillate in a multiple transverse mode with an average output exceeding 50 watts;
３　一マイクロ秒を超えるパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
iii. those that oscillate pulses with a pulse width of more than 1 microsecond which fall under any of the following clauses:
一　一パルス当たり二ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が五〇ワットを超えるもの

a. those that oscillate pulses exceeding 2 joules per pulse whose peak output exceeds 50 watts;
二　単一横モードで発振するものであって、平均出力が五〇ワットを超えるもの
b. those that oscillate in a single transverse mode with an average output exceeding 50 watts;
三　多重横モードで発振するものであって、平均出力が八〇ワットを超えるもの
c. those that oscillate in a multiple transverse mode with an average output exceeding 80 watts;
（六）　九七五ナノメートル超一、一五〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
6. those that are designed to be used in the wavelength range of more than 975 nanometers and 1,150 nanometers or less, which fall under any of the following clauses:
１　一ピコ秒未満のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
i. those that oscillate pulses with a pulse width of less than 1 picosecond which fall under either of the following clauses:
一　ピーク出力が一パルス当たり二ギガワットを超えるもの
a. those whose peak output exceeds 2 gigawatts per pulse;
二　平均出力が三〇ワットを超えるもの
b. those with an average output exceeding 30 watts;
三　一パルス当たり〇・〇〇二ジュールを超えるパルスを発振するもの
c. those that generate pulses exceeding 0.002 joules per pulse;
２　一ピコ秒以上一ナノ秒未満のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
ii. those that oscillate pulses with a pulse width of 1 picosecond or more and less than 1 nanosecond, which fall under any of the following clauses:
一　ピーク出力が一パルス当たり五ギガワットを超えるもの
a. those whose peak output exceeds 5 gigawatts per pulse;
二　平均出力が五〇ワットを超えるもの
b. those with an average output exceeding 50 watts;
三　一パルス当たり〇・一ジュールを超えるパルスを発振するもの
c. those that oscillate pulses exceeding 0.1 joules per pulse;
３　一ナノ秒以上一マイクロ秒以下のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
iii. those that oscillate pulses with a pulse width of 1 nanosecond or more and 1 microsecond or less, which fall under either of the following clauses:
一　単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
a. those that oscillate in a single transverse mode which fall under any of the following clauses:
イ　ピーク出力が一〇〇メガワットを超えるもの

1 those whose peak output exceeding 100 megawatts;
ロ　平均出力が二〇ワットを超えるものであって、最大パルス繰り返し周波数が一キロヘルツ以下になるように設計したもの
2 those with an average output exceeding 20 watts, for which the maximum pulse repetition frequency is designed to be 1 kilohertz or less;
ハ　ウォールプラグ効率が一二パーセントを超えるものであって、平均出力が一〇〇ワットを超えるもののうち、パルス繰り返し周波数が一キロヘルツを超えて作動するもの
3 among those with a wall-plug efficiency exceeding 12% and an average output exceeding 100 watts, those that operate at a pulse repetition frequency exceeding 1 kilohertz;
ニ　平均出力が一五〇ワットを超えるものであって、パルス繰り返し周波数が一キロヘルツを超えて作動するもの
4 those with an average output exceeding 150 watts, which operate at a pulse repetition frequency exceeding 1 kilohertz;
ホ　一パルス当たり二ジュールを超えるパルスを発振するもの
5 those that oscillate pulses exceeding 2 joules per pulse;
二　多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
b. those that oscillate in a multiple transverse mode which fall under any of the following clauses:
イ　ピーク出力が四〇〇メガワットを超えるもの
1 those whose peak output exceeds 400 megawatts;
ロ　ウォールプラグ効率が一八パーセントを超えるものであって、平均出力が五〇〇ワットを超えるもの
2 those with a wall-plug efficiency exceeding 18% and an average output exceeding 500 watts;
ハ　平均出力が二キロワットを超えるもの
3 those with an average output exceeding 2 kilowatts;
ニ　一パルス当たり四ジュールを超えるパルスを発振するもの
4 those that oscillate pulses exceeding 4 joules per pulse;
４　一マイクロ秒を超えるパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
iv. those that oscillate pulses with a pulse width exceeding 1 microsecond which fall under either of the following clauses:
一　単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
a. those that oscillate in a single transverse mode which fall under any of the following clauses:
イ　ピーク出力が五〇〇キロワットを超えるもの
1 those whose peak output exceeds 500 kilowatts;
ロ　ウォールプラグ効率が一二パーセントを超えるものであって、平均出力が一〇〇ワットを超えるもの

2 those with a wall-plug efficiency exceeding 12% with an average output exceeding 100 watts;
ハ　平均出力が一五〇ワットを超えるもの
3 those with an average output exceeding 150 watts;
二　多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
b. those that oscillate in a multiple transverse mode which fall under any of the following clauses:
イ　ピーク出力が一メガワットを超えるもの
1 those whose peak output exceeds 1 megawatt;
ロ　ウォールプラグ効率が一八パーセントを超えるものであって、平均出力が五〇〇ワットを超えるもの
2 those with a wall-plug efficiency exceeding 18% with an average output exceeding 500 watts;
ハ　平均出力が二キロワットを超えるもの
3 those with an average output exceeding 2 kilowatts;
（七）　一、一五〇ナノメートル超一、五五五ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
7. those designed to be used in the wavelength range of more than 1,150 nanometers and 1,555 nanometers or less, which fall under either of the following clauses:
１　一マイクロ秒以下のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
i. those that oscillate pulses with a pulse width of 1 microsecond or less which fall under any of the following clauses:
一　一パルス当たり〇・五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が五〇ワットを超えるもの
a. those that oscillate pulses exceeding 0.5 joules per pulse, and, whose peak output exceeds 50 watts;
二　単一横モードで発振するものであって、平均出力が二〇ワットを超えるもの
b. those that oscillate in a single transverse mode with an average output exceeding 20 watts;
三　多重横モードで発振するものであって、平均出力が五〇ワットを超えるもの
c. those that oscillate in a multiple transverse mode with an average output exceeding 50 watts;
２　一マイクロ秒を超えるパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
ii. those that oscillate pulses with a pulse width exceeding 1 microsecond which fall under any of the following clauses:
一　一パルス当たり二ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が五〇ワットを超えるもの
a. those that oscillate pulses exceeding 2 joules per pulse, and, whose peak

output exceeds 50 watts;
二　単一横モードで発振するものであって、平均出力が五〇ワットを超えるもの
b. those that oscillate in a single transverse mode with an average output exceeding 50 watts;
三　多重横モードで発振するものであって、平均出力が八〇ワットを超えるもの
c. those that oscillate in a multiple transverse mode with an average output exceeding 80 watts;
（八）　一、五五五ナノメートル超一、八五〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
8. those that are designed to be used in the wavelength range of more than 1,555 nanometers and 1,850 nanometers or less, which fall under either of the following clauses:
１　一パルス当たり一〇〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が一ワットを超えるもの
i. those that oscillate pulses exceeding 100 millijoules per pulse and whose peak output exceeds 1 watt; or
２　平均出力が一ワットを超えるもの
ii. those with an average output exceeding 1 watt;
（九）　一、八五〇ナノメートル超二、一〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
9. those that are designed to be used in the wavelength range of more than 1,850 nanometers and 2,100 nanometers or less, which fall under either of the following clauses:
１　単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
i. those that oscillate in a single transverse mode which fall under either of the following clauses:
一　一パルス当たり一〇〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が一ワットを超えるもの
a. those that oscillate pulses exceeding 100 millijoules per pulse, and, whose peak output exceeds 1 watt; or
二　平均出力が一ワットを超えるもの
b. those with an average output exceeding 1 watt;
２　多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
ii. those that oscillate in a multiple transverse mode which fall under either of the following clauses:
一　一パルス当たり一〇〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が一〇キロワットを超えるもの
a. those that oscillate pulses exceeding 100 millijoules per pulse, and, whose peak output exceeds 10 kilowatts; or
二　平均出力が一二〇ワットを超えるもの
b. those with an average output exceeding 120 watts;

（十）　二、一〇〇ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

10. those that are designed to be used in the wavelength range of more than 2,100 nanometers which fall under either of the following clauses:

１　一パルス当たり一〇〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が一ワットを超えるもの

i. those that oscillate pulses exceeding 100 millijoules per pulse, and, whose peak output exceeds 1 watt;

２　平均出力が一ワットを超えるもの

ii. those with an average output exceeding 1 watt;

ハ　波長可変レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの（ニに該当するものを除く。）

(c) variable wavelength laser oscillators that fall under any of the following clauses (excluding those falling under clause (d)):

（一）　六〇〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

1. those designed to be used in the wavelength range of less than 600 nanometers, which fall under either of the following clauses:

１　一パルス当たり五〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が一ワットを超えるもの

i. those that oscillate pulses exceeding 50 joules per pulse, and, whose peak output exceeds 1 watt;

２　平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの

ii. those with an average output, or rated output of continuous waves, exceeding 1 watt;

（二）　六〇〇ナノメートル以上一、四〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

2. those designed to be used in the wavelength range if more than 600 nanometers and 1,400 nanometers or less, which fall under either of the following clauses:

１　一パルス当たり一ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が二〇ワットを超えるもの

i. those that oscillates pulses exceeding 1 joule per pulse, and, whose peak output exceeding 20 watts;

２　平均出力又は持続波の定格出力が二〇ワットを超えるもの

ii. those with an average output, or rated output of continuous waves, exceeding 20 watts;

（三）　一、四〇〇ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

3. those that are designed to be used in the wavelength range exceeding 1,400 nanometers, which fall under either of the following clauses:

１　一パルス当たり五〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が一ワットを超えるもの

i. those that oscillate pulses exceeding 50 millijoules per pulse, and, with a peak output exceeding 1 watt;

２　平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの

ii. those with an average output, or rated output of continuous waves, exceeding 1 watt;

ニ　レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの

(d) laser oscillators that fall under any of the following clauses:

（一）　半導体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの

1. semiconductor laser oscillators that fall under either of the following clauses:

１　単一横モードで発振する単一の半導体レーザーダイオードであって、次のいずれかに該当するもの

i. a single semiconductor laser diode that oscillates in a single transverse mode which falls under either of the following clauses:

一　一、五一〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が一・五ワットを超えるもの

a. those that are designed be used in the wavelength range of 1,510 nanometers or less, with an average output, or rated output of continuous waves, exceeding 1.5 watts;

二　一、五一〇ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が五〇〇ミリワットを超えるもの

b. those that are designed to be used in the wavelength range of more than 1,510 nanometers, with an average output, or rated output of continuous waves, exceeding 500 milliwatts;

２　多重横モードで発振する単一の半導体レーザーダイオードであって、次のいずれかに該当するもの

ii. a single semiconductor laser diode that oscillates in a multiple transverse mode which falls under any of the following clauses:

一　一、四〇〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が二五ワットを超えるもの

a. among those that are designed to be used in the wavelength range of less than 1,400 nanometers, those with an average output, or rated output of continuous waves, exceeding 25 watts;

二　一、四〇〇ナノメートル以上一、九〇〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が二・五ワットを超えるもの

b. among those that are designed to be used in the wavelength range of 1,400 nanometers or more and less than 1,900 nanometers, those with an average output, or rated output of continuous waves, exceeding 2.5 watts;

三　一、九〇〇ナノメートル以上の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの

c. among those that are designed to be used in the wavelength range of 1,900 nanometers or more, those with an average output, or rated output of continuous waves, exceeding 1 watt;

３　単一の半導体レーザーバーであって、次のいずれかに該当するもの（４又は５の半導体レーザースタックアレーに組み込まれたものを除く。）

iii. a single semiconductor laser bar that falls under any of the following clauses (excluding those incorporated in semiconductor laser stacked arrays referred to in clause iv. or v.):

一　一、四〇〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が一〇〇ワットを超えるもの

a. one designed to be used in the wavelength range of less than 1,400 nanometers, with an average output, or rated output of continuous waves, exceeding 100 watts;

二　一、四〇〇ナノメートル以上一、九〇〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が二五ワットを超えるもの

b. one designed to be used in the wavelength range of 1,400 nanometers or more and less than 1,900 nanometer, with an average output, or rated output of continuous waves, exceeding 25 watts;

三　一、九〇〇ナノメートル以上の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が一〇ワットを超えるもの

c. one designed to be used in the wavelength range of 1,900 nanometers or more, with an average output, or a rated output of continuous waves, exceeding 10 watts;

４　半導体レーザースタックアレーであって、次のいずれかに該当するもの

iv. semiconductor laser stacked arrays that fall under any of the following clauses:

一　一、四〇〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

a. those designed to be used in the wavelength range of less than 1,400 nanometers, which fall under any of the following clauses:

イ　総平均出力又は持続波の総定格出力が三キロワット未満であって、平均出力密度又は持続波の定格出力密度が五〇〇ワット毎平方センチメートルを超えるもの

1 those with a total average output, or total rated output of continuous waves, of less than 3 kilowatts, and an average output density, or rated output density of continuous waves, exceeding 500 watts per square meter;

ロ　総平均出力又は持続波の総定格出力が三キロワット以上五キロワット以下であって、平均出力密度又は持続波の定格出力密度が三五〇ワット毎平方センチメートルを超えるもの

2 those with a total average output, or total rated output of continuous waves, of 3 kilowatts or more and 5 kilowatts or less, and an average output density, or rated output density of continuous waves, exceeding 350 watts per square meter;

ハ　総平均出力又は持続波の総定格出力が五キロワットを超えるもの

3 those with a total average output, or total rated output of continuous waves, exceeding 5 kilowatts;

ニ　ピークパルス出力密度が二、五〇〇ワット毎平方センチメートルを超えるもの（エピタキシャル成長によって形成されたモノリシック型のものを除く。）

4 those with a peak pulse output density exceeding 2,500 watts per square centimeter (excluding monolithic types formed by epitaxial growth);

ホ　空間的に干渉し得る波の総平均出力又は持続波の総定格出力が一五〇ワットを超えるもの

5 those with a total average output of waves capable of spatial interference, or total rated output of continuous waves, exceeding 150 watts;

二　一、四〇〇ナノメートル以上一、九〇〇ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

b. those designed to be used in the wavelength range of 1,400 nanometers or more and less than 1,900 nanometers, which fall under any of the following clauses:

イ　総平均出力又は持続波の総定格出力が二五〇ワット未満であって、平均出力密度又は持続波の定格出力密度が一五〇ワット毎平方センチメートルを超えるもの

1 those with a total average output, or total rated output of continuous waves, of less than 250 watts, and an average output density, or rated output density of continuous waves, exceeding 150 watts per square meter;

ロ　総平均出力又は持続波の総定格出力が二五〇ワット以上五〇〇ワット以下であって、平均出力密度又は持続波の定格出力密度が五〇ワット毎平方センチメートルを超えるもの

2 those with a total average output, or total rated output of continuous waves, of 250 watts or more and 500 watts or less, and an average output density or rated output density of continuous waves, exceeding 50 watts per square meter;

ハ　総平均出力又は持続波の総定格出力が五〇〇ワットを超えるもの

3 those with a total average output, or total rated output of continuous waves, exceeding 500 watts;

ニ　ピークパルス出力密度が五〇〇ワット毎平方センチメートルを超えるもの（エピタキシャル成長によって形成されたモノリシック型のものを除く。）

4 those with a peak pulsed output density exceeding 500 watts per square centimeter (excluding monolithic types formed by epitaxial growth); or

ホ　空間的に干渉し得る波の総平均出力又は持続波の総定格出力が一五ワットを超えるもの

5 those with a total average output of waves capable of spatial interference, or total rated output of continuous waves, exceeding 15 watts;

三　一、九〇〇ナノメートル以上の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

c. those designed to be used in a wavelength range of 1,900 nanometers or more, which fall under any of the following clauses:

イ　平均出力密度又は持続波の定格出力密度が五〇ワット毎平方センチメートルを超えるもの

1 those with an average output density or a rated output density of continuous waves, exceeding 50 watts per square meter;

ロ　総平均出力又は持続波の総定格出力が十ワットを超えるもの

2 those with a total average output or total rated output of continuous waves, exceeding 10 watts; or

ハ　空間的に干渉し得る波の総平均出力又は持続波の総定格出力が一・五ワットを超えるもの

3 those with a total average output of waves capable of spatial interference or total rated output of continuous waves, exceeding 1.5 watts;

四　３に該当する半導体レーザーバーを一以上含むもの

d. those that contain one or more semiconductor laser bars that fall under clause iii.;

５　半導体レーザースタックアレーであって、他の半導体レーザースタックアレーと結合するように設計したもののうち、他の半導体レーザースタックアレーと電子回路及び冷却ユニットを共有するための接合部を有するもの（４に該当するものを除く。）

v. among semiconductor laser stacked arrays that are designed to be combined with another semiconductor laser stacked array, those that have joining parts for sharing electronic circuits and cooling units with the other semiconductor laser stacked array (excluding those falling under clause iv.);

（二）　一酸化炭素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの

2. carbon monoxide laser oscillators that fall under either of the following clauses: or

１　一パルス当たり二ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が五キロワットを超えるもの

i. those that oscillate pulses exceeding 2 joules per pulse, and, with a peak output exceeding 5 kilowatts;

２　平均出力又は持続波の定格出力が五キロワットを超えるもの

ii. those with an average output or a rated output of continuous waves, exceeding 5 kilowatts;

（三）　二酸化炭素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの

3. carbon dioxide laser oscillators that fall under any of the following

clauses:
１　持続波の定格出力が一五キロワットを超えるもの
i. those with a rated output of continuous waves exceeding 15 kilowatts; or
２　一〇マイクロ秒を超えるパルス幅でパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
ii. those which oscillate pulses at a pulse width exceeding 10 microseconds, which fall under either of the following clauses:
一　平均出力が一〇キロワットを超えるもの
a. those with an average output exceeding 10 watts;
二　ピーク出力が一〇〇キロワットを超えるもの
b. those with a peak output exceeding 100 kilowatts;
３　一〇マイクロ秒以下のパルス幅でパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの
iii. those that oscillate pulses at a pulse width of 10 microseconds or less, which fall under either of the following clauses:
一　一パルス当たり五ジュールを超えるパルスを発振するもの
a. those that oscillate pulses exceeding 5 joules per pulse; or
二　平均出力が二・五キロワットを超えるもの
b. those with an average output exceeding 2.5 kilowatts;
（四）　エキシマレーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
4. excimer laser oscillators that fall under any of the following clauses:
１　一五〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
i. those that are designed to be used in a wavelength range of 150 nanometers or less which fall under either of the following clauses:
一　一パルス当たり五〇ミリジュールを超えるパルスを発振するもの
a. those that oscillate pulses exceeding 50 millijoules per pulse; or
二　平均出力が一ワットを超えるもの
b. those with an average output exceeding 1 watt;
２　一五〇ナノメートル超一九〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
ii. those that are designed to be used in a wavelength range of more than 150 nanometers and 190 nanometers or less, which fall under either of the following clauses:
一　一パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振するもの
a. those that oscillate pulses exceeding 1.5 joules per pulse; or
二　平均出力が一二〇ワットを超えるもの
b. those with an average output exceeding 120 watts;
３　一九〇ナノメートル超三六〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
iii. those that are designed to be used in a wavelength range of more than

190 nanometers and 360 nanometers or less, which fall under either of the following clauses:
一　一パルス当たり一〇ジュールを超えるパルスを発振するもの
a. those that oscillate pulses exceeding 10 joules per pulse; or
二　平均出力が五〇〇ワットを超えるもの
b. those with an average output exceeding 500 watts;
４　三六〇ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
iv. those that are designed to be used in a wavelength range of more than 360 nanometers, which fall under either of the following clauses:
一　一パルス当たり一・五ジュールを超えるパルスを発振するもの
a. those that oscillate pulses exceeding 1.5 joules per pulse; or
二　平均出力が三〇ワットを超えるもの
b. those with an average output exceeding 30 watts;
（五）　化学レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
5. chemical laser oscillators that fall under any of the following clauses:
１　ふっ化水素レーザー発振器
i. hydrogen fluoride laser oscillators;
２　ふっ化重水素レーザー発振器
ii. deuterium fluoride laser oscillators; or
３　トランスファーレーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
iii. transfer laser oscillators that fall under either of the following oscillators:
一　酸素からの励起移動によって励起するように設計したよう素レーザー発振器
a. iodine laser oscillators that are designed to be excited by excitation transfer from oxygen; or
二　ふっ化重水素からの励起移動によって励起するように設計した二酸化炭素レーザー発振器
b. carbon dioxide laser oscillators that are designed to be excited by excitation transfer from deuterium fluoride;
（六）　非繰返しパルスを発振するネオジムガラスレーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
6. neodymium glass laser oscillators that oscillate non-repetitive pulses, which fall under either of the following clauses:
１　一マイクロ秒以下のパルス幅でパルスを発振し、かつ、一パルス当たり五〇ジュールを超えるパルスを発振するもの
i. those that oscillate pulses at a pulse width of 1 microsecond or less, and, pulses exceeding 50 joules per pulse;
２　一マイクロ秒を超えるパルス幅でパルスを発振し、かつ、一パルス当たり一〇〇ジュールを超えるパルスを発振するもの
ii. those that oscillate pulses at a pulse width exceeding 1 microsecond, and,

pulses exceeding 100 joules per pulse;
ホ　レーザー発振器の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
(e) components of laser oscillators that fall under any of the following clauses:
（一）　反射鏡であって、ヒートパイプを用いることにより又は鏡面下一ミリメートル未満の位置に流体を流すことにより冷却するように設計したもの
1. reflectors that are designed to cool the oscillator by using a heat pipe or flowing fluid at a position that is less than 1 millimeter under the surface of the mirror;
（二）　反射鏡又は透過性を有する（部分的に透過する場合を含む。）光学部品若しくは電気光学部品であって、イからニまでのいずれかに該当するレーザー発振器に使用するように設計したもの（融着型テーパーファイバーコンバイナー及び多層膜誘電体グレーティングを除く。）
2. reflectors, or optical components or electro-optical components that have permeability (including those that are partially permeable), which are designed to be used in laser oscillators that fall under any of sub-items (a) through (d) (excluding fused tapered fiber combiners and multilayer dielectric gratings);
（三）　ファイバーレーザー発振器の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
3. components of fiber laser oscillators that fall under any of the following clauses:
１　入出力ともにマルチモードファイバーを用いた融着型テーパーファイバーコンバイナーであって、次の一及び二に該当するもの
i. fused tapered fiber combiners that use multimode fibers for both input and output, which fall under the following clauses a. and b.:
一　一、〇〇〇ワットを超える総定格平均出力又は持続波の総定格出力（シングルモードコアを通って伝送される出力を除く。）における挿入損失が〇・三デシベル以下に維持されるもの
a. those whose insertion loss at the total rated average output or the total rated output of continuous waves (excluding output transmitted through a single-mode core) exceeding 1,000 watts is maintained at 0.3 decibels or less; and
二　入力ファイバーの数が三以上のもの
b. those which have three or more input fibers;
２　入力にシングルモードファイバーを、出力にマルチモードファイバーを用いた融着型テーパーファイバーコンバイナーであって、次の全てに該当するもの
ii. fused tapered fiber combiners that use single mode fibers for input and multimode fibers for output, which fall under all of the following clauses:
一　四、六〇〇ワットを超える総定格平均出力又は持続波の総定格出力における挿入損失が〇・五デシベル未満に維持されるもの

a. those whose insertion loss at the total rated average output or the total rated output of continuous waves exceeding 4,600 watts is maintained at less than 0.5 decibels;

二　入力ファイバーの数が三以上のもの

b. those that have three or more input fibers;

三　次のいずれかに該当するもの

c. those that fall under either of the following clauses:

イ　入力ファイバーの数が五以下であって、出力におけるビームパラメータ積が一・五ミリメートル・ミリラジアン以下のもの

1 those that have five or less input fibers, whose beam parameter product at output is 1.5 millimeters milliradians or less; or

ロ　入力ファイバーの数が五を超えるものであって、出力におけるビームパラメータ積が二・五ミリメートル・ミリラジアン以下のもの

2 those that have more than five input fibers, whose beam parameter product at output is 2.5 millimeters milliradians or less;

３　多層膜誘電体グレーティングであって、次の一及び二に該当するもの

iii. multilayer dielectric gratings that fall under the following clauses a. and b.:

一　五以上のファイバーレーザー発振器のビームをスペクトル的又はコヒーレント的に結合するために設計されたもの

a. those that are designed to spectrally or coherently combine beams emitted from five or more fiber laser oscillators; and

二　持続波レーザー損傷閾値が一平方センチメートル当たり一〇キロワット以上のもの

b. those for which the threshold of continuous wave laser damage is 10 kilowatts per square centimeter or more;

ヘ　レーザー発振器の試験装置又は附属品であって、次のいずれかに該当するもの

(f) testing device or accessories of laser oscillators that fall under any of the following clauses:

（一）　削除

1. Deleted

（二）　レーザー発振器の試験装置であって、超高出力レーザー発振器（五〇ミリ秒間に一キロジュールを超えるエネルギーを出力できる又は平均出力若しくは持続波の定格出力が二〇キロワットを超えるレーザー発振器をいう。以下同じ。）のビームの振れ角の誤差を測定するために特に設計したもののうち、精度が一〇マイクロラジアン以下のもの

2. among testing device of laser oscillators which is specially designed to measure errors of the beam deflection angle of an ultra-high-power laser oscillator (meaning laser oscillators that are capable of outputting energy exceeding 1 kilojoule per 50 milliseconds, or whose average output or rated output of continuous waves exceeds 20 kilowatts; the same applies below),

those whose accuracy is 10 microradians or less;

（三）　フェーズドアレー型の超高出力レーザー発振器の附属品であって、コヒーレント光を合成するために特に設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの

3. among accessories of phased array ultra-high-power laser oscillators which are specially designed to synthesize coherent light, those which fall under either of the following clauses:

１　一マイクロメートル超の波長における精度が〇・一マイクロメートル以下のもの

i. those whose accuracy in wavelength exceeding 1 micrometer is 0.1 micrometers or less; or

２　一マイクロメートル以下の波長における精度が使用する波長の一〇分の一以下のもの

ii. those whose accuracy in wavelength of 1 micrometer or less is one-tenth of the wavelength used or less;

（四）　プロジェクションテレスコープであって、超高出力レーザー発振器と組み合わせて使用するように設計したもの

4. projection telescopes that are designed to be used in combination with ultra-high output laser oscillators;

十の二　レーザー光を利用して音声を探知する装置であって、次のイからホまでの全てに該当するもの

(x)-2 devices for detecting sounds by using laser beams, which fall under all of the following sub-items (a) through (e):

イ　レーザー発振器の持続波の定格出力が二〇ミリワット以上のもの

(a) those whose rated output of continuous waves of the laser oscillator is 20 milliwatts or more;

ロ　レーザー発振器の周波数の安定度が一〇メガヘルツ以下のもの

(b) those for which stability of frequency of the laser oscillator is 10 megahertz or less;

ハ　レーザー発振器の波長範囲が一、〇〇〇ナノメートル以上二、〇〇〇ナノメートル以下のもの

(c) those for which the wavelength range of the laser oscillator is 1,000 nanometers or more and 2,000 nanometers or less;

ニ　光学系の分解能が一ナノメートル未満のもの

(d) those for which the resolving power of the optical system is less than 1 nanometer; and

ホ　信号対雑音比が一、〇〇〇以上のもの

(e) those for which the signal noise ratio is 1,000 or more;

十一　磁力計、磁場勾配計（医療用に設計したものを除く。）若しくは水中電場センサー（漁業用を除く。）若しくはこれらの校正装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(xi) magnetometers, magnetic field gradiometers (excluding those designed for medical use) or underwater electric field sensors (excluding those for fishery) or their calibration equipment, or their components, which fall under any of the following sub-items:

イ　超電導の技術を利用した磁力計であって、次のいずれかに該当するもの

(a) magnetometers that utilize superconducting technology, which fall under any of the following clauses:

（一）　静止状態で操作するように設計したものであって、運動中に生じるノイズを減少させるために設計した装置を有しないもののうち、一ヘルツの周波数における感度（帯域周波数の平方根当たりで表した実効値をいう。以下同じ。）が五〇フェムトテスラ以下のもの

1. among those that are designed to operate in a stationary state and do not have a device that is designed to reduce noise generated when in motion, those for which the sensitivity at frequency of 1 hertz (meaning the effective value expressed per square root of the band frequency; the same applies below) is 50 femtoteslas or less;

（二）　運動中に生じるノイズを減少させるために設計した装置を有するものであって、一ヘルツの周波数において運動中の感度が二〇ピコテスラ未満のもの

2. those that have a device that is designed to reduce noise generated when in motion, whose sensitivity when in motion at a frequency of 1 hertz is less than 20 picoteslas;

ロ　光ポンプ又は核磁気共鳴の技術を利用した磁力計であって、一ヘルツの周波数における感度が二ピコテスラ未満のもの

(b) those that utilize optical pump technology or nuclear magnetic resonance technology, whose sensitivity at a frequency of 1 hertz is less than 2 picoteslas;

ハ　光ポンプ又は核磁気共鳴の技術を利用した磁力計であって、一ヘルツの周波数における感度が二ピコテスラ以上二〇ピコテスラ未満のもの

(c) those that utilize optical pump technology or nuclear magnetic resonance technology, whose sensitivity at a frequency of 1 hertz is 2 picoteslas or more and less than 20 picoteslas;

ニ　三軸フラックスゲートの技術を利用した磁力計であって、一ヘルツの周波数における感度が一〇ピコテスラ以下のもの

(d) those that utilize triaxial flux gate technology, whose sensitivity at a frequency of 1 hertz is 10 picoteslas or less;

ホ　誘導コイルを用いた磁力計であって、次のいずれかに該当するもの

(e) magnetometers using an induction coil, which fall under any of the following clauses:

（一）　一ヘルツ未満の周波数における感度が〇・〇五ナノテスラ未満のもの

1. those whose sensitivity at a frequency of less than 1 hertz is less than 0.05 nanoteslas;

（二）　一ヘルツ以上一〇ヘルツ以下の周波数における感度が〇・〇〇一ナノテスラ未満のもの

2. those whose sensitivity at frequency of 1 hertz or more and 10 hertz or less is less than 0.001 nanoteslas; or

（三）　一〇ヘルツを超える周波数における感度が〇・〇〇〇一ナノテスラ未満のもの

3. those whose sensitivity at frequency exceeding 10 hertz is less than 0.0001 nanoteslas;

ヘ　光ファイバーを用いた磁力計であって、感度が一ナノテスラ未満のもの

(f) magnetometers that use optical fibers whose sensitivity is less than 1 nanotesla;

ト　水中電場センサーであって、一ヘルツの周波数で測定した場合の感度が八ナノボルト毎メートル未満のもの

(g) underwater electric field sensors whose sensitivity measured at a frequency of 1 hertz is less than 8 nanovolts per meter;

チ　磁場勾配計であって、イからヘまでのいずれかに該当する磁力計を二以上用いたもの

(h) magnetic field gradiometers using two or more magnetometers that fall under any of sub-items (a) through (f);

リ　光ファイバーを用いた磁場勾配計であって、イントリンシック型のもの（一軸当たりの検出素子の数が一のものをいう。以下この号において同じ。）のうち、感度が〇・三ナノテスラ毎メートル未満のもの

(i) among magnetic filed gradiometers that use optical fibers which are intrinsic gradiometers (meaning those with the number of detection elements per axis of one; the same applies below in this item), those whose sensitivity is less than 0.3 nanoteslas per meter;

ヌ　光ファイバーを用いていない磁場勾配計であって、イントリンシック型のもののうち、感度が〇・〇一五ナノテスラ毎メートル未満のもの

(j) among magnetic field gradiometers that do not use optical fibers which are intrinsic gradiometers, those whose sensitivity is less than 0.015 nanoteslas per meter;

ル　磁力計、磁場勾配計又は水中電場センサーの校正装置であって、イからヌまでのいずれかに該当する貨物の有する機能と同等以上の機能を有する磁力計、磁場勾配計又は水中電場センサー用に設計したもの（ヲに該当するものを除く。）

(k) among calibration equipment for magnetometers, magnetic gradiometers, or underwater electric field sensors, those that are designed for magnetometers, magnetic field gradiometers, or underwater electric field sensors which have functions equivalent to or exceeding the functions of the goods that fall under any of sub-items (a) through (j) (excluding goods falling under sub-item (l)));

ヲ　磁力計、磁場勾配計又は水中電場センサーの校正装置であって、次のいずれか

に該当する貨物用に設計したもの

(l) calibration equipment for magnetometers, magnetic field gradiometers, or underwater electric field sensors, which are designed for the goods falling under any of the following clauses:

（一）　ハに該当する磁力計であって、感度が二ピコテスラ未満を実現する光ポンプ又は核磁気共鳴の技術を利用したもの

1. magnetometers that fall under sub-item (c), which utilize optical pump techmology or nuclear magnetic resonance technology to achieve a sensitivity of less than 2 picoteslas;

（二）　トに該当する水中電場センサー

2. underwater electric field sensors that fall under sub-item (g);

（三）　チからヌまでのいずれかに該当する磁場勾配計であって、感度が三ピコテスラ毎メートル未満を実現するもの

3. magnetic field gradiometers that fall under any of sub-items (h) through (j), which achieve a sensitivity of less than 3 picoteslas;

ワ　磁場勾配計であって、イ又はロに該当する磁力計を用いたもの

(m) magnetic field gradiometers that use magnetometers falling under sub-item (a) or (b);

十一の二　水中において磁場又は電場を検知する装置であって、次のいずれかに該当するもの

(xi)-2 devices for detecting magnetic fields or electric fields underwater, which fall under any of the following:

イ　第十一号イ又はロに該当する磁力計を組み込んだもの

(a) devices that have magnetometers incorporated, which fall under item (xi), sub-item (a) or (b);

ロ　第十一号ハからヘまでのいずれかに該当する磁力計又は同号トに該当する水中電場センサーを組み込んだもの

(b) devices that have magnetometers incorporated, which fall under any of item (xi), sub-items (c) through (f), or have underwater electric field sensors incorporated, which fall under sub-item (g) of that item;

十二　重力計であって、次のいずれかに該当するもの又は重力勾配計

(xii) gravity meters that fall under any of the following clauses, or gravity gradiometers:

イ　地上用に設計した重力計であって、静止状態において重力を測定する場合の精度が一〇マイクロガル未満のもの（ウォルドン型のものを除く。）

(a) gravity meters that are designed for ground use with an accuracy of less than 10 microgals when gravity is measured in a stationary state (excluding Worden- type gravity meters);

ロ　移動体搭載用に設計した重力計であって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(b) gravity meters that are designed to be mounted on mobile bodies, which

fall under the following clauses 1. and 2.:

（一）　静止状態において重力を測定する場合の精度が〇・七ミリガル未満のもの

1. gravity meters with an accuracy of less than 0.7 milligals when gravity is measured in a stationary state; and

（二）　変動状態において重力を測定する場合の精度が〇・七ミリガル未満で、かつ、測定所要時間が二分未満のもの

2. those with an accuracy of less than 0.7 milligals when gravity is measured in a transitory condition, and, the required measuring time is less than 2 minutes;

十三　レーダーであって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品（二次監視レーダー、民生用自動車レーダー、気象レーダー、国際民間航空機関の定める標準に準拠した精測進入レーダー及びこれらの部分品（レーダーの部分品であって航空管制用の表示装置を含む。）を除く。）

(xiii) radar that falls under any of the following sub-items, or its components (excluding secondary surveillance radar, civilian automotive radar, meteorological radar, precision approach radar that conform to the standards established by the International Civil Aviation Organization, and its components (including component of a radar which is a display equipment for air traffic control):

イ　四〇ギガヘルツ以上二三〇ギガヘルツ以下の周波数範囲で使用することができるレーダーであって、次のいずれかに該当するもの

(a) radar that can be used in the frequency range of 40 gigahertz or more and 230 gigahertz or less, which fall under either of the following clauses:

（一）　平均出力が一〇〇ミリワットを超えるもの

1. one with an average output exceeding 100 milliwatts;

（二）　距離の位置精度が一メートル以下であって、方位角の位置精度が〇・二度以下のもの

2. one with a position accuracy of distance of 1 meter or less, and azimuth postion accuracy of 0.2 degrees or less;

ロ　同調可能な帯域の幅が中心周波数の一二・五パーセントを超えるもの

(b) radar whose tunable bandwidth exceeds 12.5% of the center frequency;

ハ　三以上の搬送周波数を同時に使用することができるもの

(c) one that is capable of using three or more carrier frequencies simultaneously;

ニ　合成開口レーダー、逆合成開口レーダー又は側方監視レーダーとして使用することができるもの

(d) one that may be used as synthetic aperture radar, inverse synthetic aperture radar, or side-looking radar;

ホ　電子的に走査が可能なアレーアンテナを組み込んだもの

(e) one in which array antennas that are capable of electronic scanning are

installed;

ヘ　目標の高度を測定することができるもの

(f) one that is capable of measuring the altitude of a target;

ト　気球又は航空機に搭載するように設計したものであって、移動する目標を検出するためにドップラー効果を利用するもの

(g) one that is designed to be installed on balloons or aircraft, which utilizes the Doppler effect to detect a moving target;

チ　次のいずれかの技術を利用するもの

(h) one which utilizes either of the following technologies:

（一）　スペクトル拡散

1. spread spectrum;

（二）　周波数アジリティー

2. frequency agility;

リ　地上用のものであって、計測距離が一八五キロメートルを超えるもの（漁場監視レーダー、航空管制用に設計した地上レーダー及び気象用気球追尾レーダーを除く。）

(i) one for ground use with a measurable distance exceeding 185 km (excluding fishing ground surveillance radar, ground radar designed for air traffic control, and meteorological balloon tracking radar);

ヌ　レーザーレーダー（ライダーを含む。）であって、次のいずれかに該当するもの

(j) laser radar (including LiDAR) that falls under any of the following clauses:

（一）　宇宙用に設計したもの

1. one designed for space use;

（二）　ヘテロダイン検波又はホモダイン検波の技術を利用し、かつ、角度分解能が二〇マイクロラジアン未満のもの

2. one that utilizes heterodyne phase detection technology or homodyne phase detection technology, and, with an angular resolving power of less than 20 microradians;

（三）　航空機を使用して測深による沿岸測量を実施するように設計したものであって、国際水路機関が定める水路測量に係る基準に照らして十分な精度を有し、かつ、四〇〇ナノメートル超六〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用する一以上のレーザー発振器を用いるもの

3. one that is designed for coastal surveys through bathymetry using aircraft, which has sufficient accuracy in light of the standards established by the International Hydrographic Organization for hydrographic surveys, and, uses one or more laser oscillators that is used in the wavelength range of more than 400 nanometers and 600 nanometers or less;

ル　次のいずれかに該当するパルス圧縮技術を利用するもの

(k) one utilizing pulse compression technology that falls under either of the

following clauses:

（一）　パルス圧縮比が一五〇を超えるもの

1. one with a pulse compression ratio exceeding 150;

（二）　圧縮パルス幅が二〇〇ナノ秒未満のもの（航海用二次元レーダー又は船舶航行サービス用二次元レーダーであって、次の１から５までの全てに該当するものを除く。）

2. one with a compressed pulse width of less than 200 nanoseconds (excluding two-dimensional marine radar or two-dimensional radar for vessel navigation services, which falls under all of the following clauses i. through v.):

１　パルス圧縮比が一五〇以下のもの

i. one with a pulse compression ratio of 150 or less;

２　圧縮パルス幅が三〇ナノ秒を超えるもの

ii. one with a compressed pulse width exceeding 30 nanoseconds;

３　単一の回転する機械式走査アンテナを有するもの

iii. one that has a single rotating mechanical scanning antenna;

４　ピーク出力が二五〇ワット以下のもの

iv. one with a peak output of 250 watts or less; and

５　周波数ホッピング能力を有していないもの

v. one that does not have a frequency hopping capability;

ヲ　次のいずれかに該当するデータ処理技術を利用するもの（船舶航行サービスのために設計された装置又はその部分品を除く。）

(l) one utilizing data processing technology that falls under any of the following clauses (excluding devices that arevdesigned for vessel navigation services, or their components):

（一）　自動目標追尾の技術であって、次回のアンテナビームが通過する時点より先の時点における目標の未来位置を予測することができるもの（航空管制用又は航海用レーダーの衝突防止機能を除く。）

1. automatic target tracking technology that is capable of forecasting the future position of a target starting from the point where the next antenna beam will pass (excluding collision prevention functions for air traffic control or of marine radar);

（二）　削除

2. Deleted

（三）　第十三号ヘ又はリに該当する一のレーダーを単独で使用するときよりも性能が向上するよう、互いの距離が一、五〇〇メートル以上離れている二以上のレーダーから得られる目標データの重ね合わせ、相関又はデータフュージョンを六秒以内で行う技術

3. technology that carries out the superposition, correlation, or fusion of target data obtained from two or more radars with a distance of more than 1,500 meters from each other within 6 seconds, in order to improve the

performance compared to when using of a single radar falling under item (xiii), sub-item (f) or (i);

（四）　第十三号ヘ又はリに該当する一のレーダーを単独で使用するときよりも性能が向上するよう、車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に搭載したレーダーを含む二以上のレーダーから得られる目標データの重ね合わせ、相関又はデータフュージョンを六秒以内で行う技術

4. technology that carries out the superposition, correlation, or fusion of target data obtained from two or more radars including a radar installed on vehicles, vessels, aircraft, or artificial satellites, or other flying objects for space development within 6 seconds, in order to improve the performance compared to when using a single radar falling under item (xiii), sub-item (f) or (i);

十三の二　第三号イ（二）又は（三）のいずれかに該当する光センサーの製造用に特別に設計されたマスク又はレチクル

(xiii)-2 masks or reticles specially designed for manufacturing optical sensors that fall under either of item (iii), sub-item (a), 2. or 3.:

十四　光学の測定装置であって、次のいずれかに該当するもの

(xiv) optical measuring equipment that falls under either of the following sub-items:

イ　光の反射率の測定装置（反射率の絶対値を測定するものに限る。）であって、その精度が〇・一パーセント以下のもの

(a) measuring equipment for optical reflectance (limited to those which measure the absolute value of reflectance) whose accuracy is 0.1 percent or less; or

ロ　レンズ又は反射鏡の表面の形状の測定装置（非接触型のものに限る。）であって、光散乱の計測以外の方法を用いるもののうち、開口の直径が一〇センチメートルを超え、かつ、平面でない面形状を二ナノメートル以下の精度で測定するように設計したもの

(b) among measuring equipment for the surface shape of lenses or reflectors (limited to non-contact type ones) which uses a method other than the light scattering measurement method, one that has an aperture diameter exceeding 10 centimeters, and, is designed for measuring a surface shape that is not a plane surface with an accuracy of 2 nanometers or less;

十五　地上用の重力計（静止状態において重力を測定する場合の精度が〇・一ミリガル未満のものに限る。）の製造用の装置又は校正装置

(xv) devices for manufacturing gravity meters for ground use or calibration equipment (limited to those with a precision of less than 0.1 milligals when gravity is measured in a stationary state);

十六　光検出器その他の光学部品の材料となる物質又はレーザー発振器用の結晶であって、次のいずれかに該当するもの

(xvi) substances that are to be materials for optical detectors and other optical

components, or crystals for laser oscillators, which fall under any of the following sub-items:

イ　テルルであって、純度が九九・九九九五パーセント以上のもの

(a) tellurium with a purity of 99.9995% or more;

ロ　次のいずれかに該当するものの単結晶又はエピタキシャル成長結晶を有するウエハー

(b) wafers having a single crystal or epitaxial growth crystal of substances that fall under any of the following clauses:

（一）　テルル化亜鉛のテルル化カドミウム及びテルル化亜鉛に対するモル比が六パーセント未満のテルル化亜鉛カドミウム

1. cadmium zinc telluride for which the mole ratio of zinc telluride to cadmium telluride and zinc telluride is less than 6%;

（二）　テルル化カドミウム

2. cadmium telluride; or

（三）　テルル化水銀カドミウム

3. cadmium mercury telluride;

ハ　セレン化亜鉛又は硫化亜鉛からなる基板材料であって、化学的気相成長法により製造したもののうち、次のいずれかに該当するもの

(c) among substrate materials made of zinc selenide or zinc sulfide which are manufactured by chemical vapor phase growth methods, those that fall under either of the following clauses:

（一）　体積が一〇〇立方センチメートルを超えるもの

1. those whose volume exceeds 100 cubic centimeters; or

（二）　直径が八〇ミリメートルを超え、かつ、厚さが二〇ミリメートル以上のもの

2. those whose diameter exceeds 80 millimeters, and, has a thickness of 20 millimeters or more;

ニ　電気光学材料又は非線形光学材料であって、次のいずれかに該当するもの

(d) electro-chemical materials or non-linear optical materials that fall under any of the following clauses:

（一）　砒素酸チタニルカリウム

1. potassium titanyl arsenate;

（二）　セレン化ガリウム銀

2. silver gallium selenide;

（三）　セレン化タリウム砒素

3. arsenic thallium selenide;

（四）　リン化亜鉛ゲルマニウム

4. zinc germanium phosphide; or

（五）　セレン化ガリウム

5. gallium selenide;

ホ　非線形光学材料であって、次のいずれかに該当するもの（ニに該当するものを

除く。）

(e) non-linear optical materials that fall under any of the following clauses (excluding those that fall under sub-item (d)):

（一）　動的な三次の非線形感受率が一〇〇万分の一平方メートル毎ボルト毎ボルト以上であって、応答時間が一ミリ秒未満のもの

1. those whose dynamic third-order non-linear susceptibility is greater than 1/1,000,000 per square meter per volt per volt, with a response time of less than 1 millisecond;

（二）　メートル毎ボルトで表した二次の非線形感受率が一兆分の三三以上のもの

2. those whose quadratic non-linear susceptibility expressed in meter per volt is 33/1,000,000,000,000 or more,;

ヘ　ベリリウム上にベリリウムを堆積した材料又は炭化けい素からなる基板材料であって、直径又は長軸の長さが三〇〇ミリメートルを超えるもの

(f) those made from materials having beryllium stacked on beryllium or substrate material made from silicon carbide, that have a diameter or length of the long axis that exceeds 300 millimeters;

ト　光学ガラスであって、次の（一）から（三）までのすべてに該当するもの

(g) optical glass that falls under all of the following clauses 1. through 3.:

（一）　水酸化物イオンの含有量が全重量の〇・〇〇〇五パーセント未満のもの

1. one with the hydroxide ion content of less than 0.0005% of the total weight;

（二）　金属不純物の含有量が全重量の〇・〇〇〇一パーセント未満のもの

2. one with the metal impurities content of less than 0.0001% of the total weight; and

（三）　屈折率の変動が一〇〇万分の五未満のもの

3. one with the fluctuation of the refractive index of less than 5/1,000,000;

チ　人工ダイヤモンドであって、二〇〇ナノメートル超一四、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲における吸収係数が一センチメートル当たり一〇万分の一未満のもの

(h) artificial diamonds with the absorption coefficient of less than 1/100,000 per centimeter in the wavelength range of more than 200 nanometers and 14,000 nanometers or less;

リ　レーザー発振器用の人工の結晶であって、未完成のもののうち、チタンを添加したサファイア

(i) among artificial crystals for laser oscillators which are unfinished, sapphires with titanium added;

ヌ　希土類元素を添加したダブルクラッドファイバーであって、次のいずれかに該当するもの

(j) double clad fibers to which rare-earth elements are added, which fall under any of the following clauses:

（一）　レーザー波長の公称値が九七五ナノメートル以上一、一五〇ナノメートル以下であって、次の１及び２に該当するもの（インナーガラスクラッドの直径が一五〇マイクロメートル超三〇〇マイクロメートル以下のものを除く。）

1. those for which the nominal value of the laser wavelength is 975 nanometers or more and 1,150 nanometers or less, which fall under the following clauses i. and ii. (excluding those with the inner glass clad is more than 150 micrometers and 300 micrometers or less in diameter):

１　コアの直径の平均値が二五マイクロメートル以上のもの

i. those for which the mean value of the diameter of the core is 25 micrometers or more; and

２　コアの開口数が〇・〇六五未満のもの

ii. those for which the numerical aperture of the core is less than 0.065;

（二）　レーザー波長の公称値が一、五三〇ナノメートルを超えるものであって、次の１及び２に該当するもの

2. those for which the nominal value of the laser wavelength exceeds 1,530 nanometers, which fall under the following clauses i. and ii.:

１　コアの直径の平均値が二〇マイクロメートル以上のもの

i. those for which the mean value of the diameter of the core is 20 micrometers or more; and

２　コアの開口数が〇・一未満のもの

ii. those for which the numerical aperture of the core is less than 0.1;

第十条　輸出令別表第一の一一の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 10　The goods with specifications prescribed by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 11 of the Appended Table 1 of the Export Order are those that fall under any of the following items:

一　加速度計であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品

(i) accelerometers that fall under any of the following sub-items, or their components:

イ　直線加速度計であって、次のいずれかに該当するもの

(a) linear accelerometers that fall under any of the following clauses:

（一）　一四七・一五メートル毎秒毎秒以下の直線加速度で使用することができるように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

1. those that are designed so that they may be used at a linear acceleration of 147.15 meters per second squared, which fall under any of the following clauses:

１　バイアスの安定性（校正後のものをいう。以下この条において同じ。）が一年間につき〇・〇〇一二八メートル毎秒毎秒未満のもの

i. those with a bias stability (meaning those after calibration; the same applies below in this Article) of less than 0.00128 meters per second

squared per year;

２　スケールファクターの安定性が一年間につき〇・〇一三パーセント未満のもの

ii. those with a scale factor stability of less than 0.013 % per year;

（二）　一四七・一五メートル毎秒毎秒超九八一メートル毎秒毎秒以下の直線加速度で使用することができるように設計したものであって、次の１及び２に該当するもの

2. those that are designed so that they can be used at a linear acceleration of more than 147.15 meters per second squared and 981 meters per second squared or less, which fall under the following clauses i. and ii.:

１　バイアスの再現性が一年間につき〇・〇一二二六二五メートル毎秒毎秒未満のもの

i. those with a reproducibility of bias of less than 0.0122625 meters per second squared per year; and

２　スケールファクターの再現性が一年間につき〇・一二五パーセント未満のもの

ii. those with a scale-factor reproducibility of less than 0.125% per year;

（三）　慣性航法装置又は慣性誘導装置に使用するように設計したものであって、九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの

3. those that are designed to be used in inertial navigation systems or inertial guidance systems, which are designed so that they may be used at a linear acceleration exceeding 981 meters per second squared;

ロ　角加速度計又は回転加速度計であって、九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの

(b) angular accelerometers or rotational accelerometers that are designed so that they may be used at a linear acceleration exceeding 981 meters per second squared;

二　ジャイロスコープ若しくは角速度センサーであって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品

(ii) gyroscopes or angular velocity sensors, which fall under any of the following clauses, or their components:

イ　九八一メートル毎秒毎秒以下の直線加速度で使用することができるように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

(a) those that are designed so that they can be used at a linear acceleration of 981 meters per second squared or less, which fall under any of the following clauses:

（一）　角速度の測定範囲が一秒当たり五〇〇度未満のものであって、次のいずれかに該当するもの

1. those whose measuring range of the angular velocity is less than 500 degrees per second, which fall under any of the following clauses:

１　バイアスの安定性が、九・八一メートル毎秒毎秒の状態で一月間測定した場合に、一時間あたり〇・五度未満のもの

i. those with a bias stability of less than 0.5 degrees per hour when measured in the state in which it is 9.81 meters per second squared for a period of one month;

２　角度のランダムウォークを時間の平方根当たりで表した実効値が〇・〇〇三五度以下のもの（スピニングマスジャイロを除く。）

ii. those for which the effective value of the angle random walk expressed in per square root of time is 0.0035 degrees or less (excluding spinning mass gyros);

（二）　角速度の測定範囲が一秒当たり五〇〇度以上のものであって、次のいずれかに該当するもの

2. those with the measuring range of the angular velocity of 500 degrees per second or more, which fall under any of the following clauses:

１　バイアスの安定性が、九・八一メートル毎秒毎秒の状態で三分間測定した場合に、一時間につき四度未満のもの

i. those with a bias stability of less than 4 degrees per hour when measured in the state in which it is 9.81 meters per second squared for three minutes;

２　角度のランダムウォークを時間の平方根当たりで表した実効値が〇・一度以下のもの（スピニングマスジャイロを除く。）

ii. those for which the effective value of the angle random walk expressed in per square root of time is 0.1 degrees or less (excluding spinning mass gyros);

ロ　九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの

(b) those that are designed so that they can be used at a linear acceleration that exceeds 981 meters per second squared;

三　慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置（姿勢方位基準装置、ジャイロコンパス、慣性計測装置及び慣性基準装置を含む。）であって、次のいずれかに該当するもの（本邦又は別表第二に掲げる地域のいずれかの政府機関が民間航空機用であることを証明したものを除く。）

(iii) inertial navigation systems and other devices that utilize inertial force (including attitude and heading reference systems, gyro compasses, inertial measurement units, and inertial reference system), which fall under any of the following sub-items (excluding those certified by any of the governmental organizations of Japan or the regions stated in the Appended Table 2 that they are for civilian aircraft):

イ　航空機用、陸上車両用又は船舶用に設計されたものであって、位置参照情報によらずに位置情報を提供するもののうち、ノーマルアライメント後の精度が次のいずれかに該当するもの

(a) among those that are designed for aircraft, land vehicles, or vessels which provide locational information without relying on location reference information, those for which the accuracy after normal alignment falls under any of the following clauses:

（一）　平均誤差半径が一時間につき〇・八海里以下のもの

1. those for which the circular error probability is 0.8 nautical miles per hour or less;

（二）　平均誤差半径が移動距離の〇・五パーセント以下のもの

2. those for which the circular error probability is 0.5% or less of the movement distance;

（三）　平均誤差半径が二四時間で総ドリフト一海里以下のもの

3. those for which the circular error probability is total drift of 1 nautical mile or less in 24 hours;

ロ　航空機用、陸上車両用又は船舶用に設計され、位置参照情報を内蔵するものであって、全ての位置参照情報の喪失後四分以内に位置情報を提供し、平均誤差半径が一〇メートル未満のもの

(b) those that are designed for aircraft, land vehicles, or vessels, which have location reference information incorporated, which provide locational information within 4 minutes after the loss of all location reference information with the circular error probability of less than 10 meters;

ハ　航空機用、陸上車両用又は船舶用に設計され、真北方向を示すものであって、次のいずれかに該当するもの

(c) those that are designed for aircraft, land vehicles, or vessels and indicate the true north direction, which fall under any of the following clauses:

（一）　最大動作角速度が一秒当たり五〇〇度未満であって、位置参照情報を用いない機首方位精度が〇・〇七度を測定地点の緯度の余弦で除した値以下又は緯度四五度の地点において六分以下のもの

1. those with the maximum operating angular velocity of less than 500 degrees per second and the heading accuracy without using location reference information is less than the value obtained by dividing 0.07 degrees by the cosine of the latitude of the measurement point, or six minutes or less at the point of 45 degrees latitude;

（二）　最大動作角速度が一秒当たり五〇〇度以上であって、位置参照情報を用いない機首方位精度が〇・二度を測定地点の緯度の余弦で除した値以下又は緯度四五度の地点において一七分以下のもの

2. those with the maximum operating angular velocity of 500 degrees per second or more and the haeding accuracy without using location reference information is less than the value obtained by dividing 0.2 degrees by the cosine of the latitude of the measurement point, or 17 minutes or less at the point of 45 degrees latitude;

ニ　二次元以上において、加速度測定値又は角速度測定値を提供するものであって、

次のいずれかに該当するもの

(d) those that provide acceleration measurement values or angular velocity measurement values in two dimensions or more, which fall under any of the following clauses:

（一）　任意の軸に沿って、いかなる参照情報も使用することなく、第一号又は前号に規定する仕様のもの

1. those that have the specification prescribed in item (i) or the preceding item, without using any reference information along an arbitrary axis;

（二）　宇宙用に設計したものであって、任意の軸に沿った角度のランダムウォークを時間の平方根当たりで表した実効値が〇・一度以下で、かつ、角速度の測定値を与えるもの（スピニングマスジャイロのみを組み込んだ慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置を除く。）

2. those that are designed for space use for which the effective value of the angle random walk along an arbitrary axis expressed in per square root of time is 0.1 degrees or less, and, which provide angular velocity measurement values (excluding inertial navigation systems that only have spinning mass gyros incorporated and other devices that utilize inertial force);

四　ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(iv) gyro-astro compass, devices that are capable of determining positions or courses by automatically tracking celestial bodies or artificial satellites, or their components, which fall under any of the following sub-items:

イ　ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置であって、方位精度が二〇秒以下のもの

(a) gyro-astro compasses or devices that are capable of determining positions or courses by automatically tracking celestial bodies or artificial satellites, which have a bearing accuracy of 20 seconds or less;

ロ　イに該当するジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置のために設計した部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(b) components that are designed for gyro-astro compasses or devices that are capable of determining positions or courses by automatically tracking celestial bodies or artificial satellites falling under sub-item (a), which fall under either of the following clauses:

（一）　光学ヘッド又はバッフル

1. optical heads or baffles; or

（二）　データ処理ユニット

2. data processing units;

五　衛星航法システムからの電波を受信する装置であって、次のいずれかに該当する

もの又はその部分品

(v) devices that receive radio waves from global navigation satellite systems, which fall under any of the following sub-items, or their components:

イ　位置及び時刻に関するレンジングコードにアクセスするための暗号の復号アルゴリズムを有するもの（民生用に設計されたものを除く。）

(a) those that have a decoding algorithm for accessing the ranging code for position and time (excluding those designed for civilian use);

ロ　アダプティブアンテナシステムを構成するもの

(b) those that constitute an adaptive antenna system;

六　航空機用の高度計であって、四・四ギガヘルツを超える周波数又は四・二ギガヘルツより低い周波数で使用することができるように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの

(vi) among aircraft altimeters that are designed to be used at a frequency greater than 4.4 gigahertz or at a frequency lower than 4.2 gigahertz, those which fall under either of the following sub-items:

イ　送信出力制御機能を有するもの

(a) those that have a transmission output control function; or

ロ　位相偏移変調機能を有するもの

(b) those that have a phase-shift keying function;

七　水中ソナー航法装置であって、方位情報を用い、かつ、ドップラー速度ログ若しくは相関速度ログを用いるもののうち、位置精度が平均誤差半径で移動した距離の三パーセント以下のもの又はその部分品

(vii) among underwater sonar navigation equipement that use azimuth information, and, use Doppler velocity log or correlation velocity log, those that have a position accuracy of 3% or less of the distance moved by circular error probability, or their components;

八　第一号から第七号までのいずれかに該当するものの試験装置、校正装置、心合わせ装置又は製造用の装置

(viii) testing device, calibration equipment, alignment equipment or devices for manufacturing, which fall under any of items (i) through (vii);

九　リングレーザージャイロの鏡面の特性確認のために設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの

(ix) devices that are designed to confirm the characteristics of the mirror surface of a ring laser gyro, which fall under either of the following sub-items:

イ　スキャッタロメータであって、測定精度が〇・〇〇一パーセント以下のもの

(a) scatterometers that have a measuring precision of 0.001% or less; or

ロ　プロフィロメータであって、測定精度が〇・五ナノメートル以下のもの

(b) profilometers that have a measuring precision of 0.5 nanometers or less.

第十一条　輸出令別表第一の一二の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいず

れかに該当するものとする。

Article 11 The goods with specifications prescribed by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 12 of the Appended Table 1 of the Export Order are those that fall under any of the following items:

一　有人式であり、かつ、繋索式の潜水艇であって、一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの

(i) manned and tethered type submersibles that are designed so that they may be used at water depths exceeding 1,000 meters;

一の二　無人式の潜水艇であって、次の全てに該当するもの

(i)-2 unmanned submersibles that fall under all of the following sub-items:

イ　繋索式で使用することができるように設計したもの

(a) those that are designed so that they be used as tethered submersibles;

ロ　一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの

(b) those that are designed so that they can be used at water depths exceeding 1,000 meters;

ハ　次のいずれかに該当するもの

(c) those that fall under either of the following clauses:

（一）　直流の推進電動機又はスラスターを使用して、独力で潜航することができるように設計したもの

1. those that are designed so that they are capable of cruising underwater by their own power using direct current propulsion electric motors or thrusters; or

（二）　光ファイバーによってデータを送受することができるもの

2. those that are capable of sending and receiving data using optical fibers;

二　二五〇メートルを超える水深にある物体を回収するための装置であって、五メガニュートンを超える揚荷能力を有し、かつ、次のいずれかに該当するもの

(ii) devices that are used to recover objects found at water depths exceeding 250 meters that have a cargo unloading capability exceeding 5 meganewtons, and, fall under either of the following sub-items:

イ　航法装置によって設定した点から二〇メートル以内の範囲に位置を保持することができる自動船位保持装置を有するもの

(a) those that have a dynamic positioning system capable of maintaining the position of a vessel within the range of 20 meters from a point set by the navigation equipment; or

ロ　一、〇〇〇メートルを超える水深において、あらかじめ定められた点から一〇メートルの範囲に位置を保持することができるもの

(b) those capable of maintaining the position within the range of 10 meters from a predetermined point at water depths exceeding 1,000 meters;

三　削除

(iii) Deleted

四　潜水艇の部分品又は附属装置であって、次のいずれかに該当するもの

(iv) components or auxiliary equipment for submersibles, which fall under any of the following sub-items:

イ　一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計した潜水艇の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(a) those that are designed so that they may be used at water depths exceeding 1,000 meters, which fall under any of the following clauses:

（一）　最大の内のり寸法が一・五メートルを超える耐圧容器又は耐圧殻

1. pressure-resistant containers or pressure-resistant shells with the maximum internal dimension exceeding 1.5 meters;

（二）　直流の推進電動機又はスラスター

2. direct current propulsion electric motors or thrusters;

（三）　光ファイバー及び合成材のテンションメンバを使用したアンビリカルケーブル又はそのコネクタ

3. umbilical cables or their connectors that use optical fibers and tension members made from synthetic materials; or

（四）　第十二号に該当する材料を用いた部分品

4. components using a material that falls under item (xii);

ロ　潜水艇に使用することができるように設計した自動制御装置であって、航法データを使用し、かつ、サーボ制御方式であるもののうち、次の（一）及び（二）に該当するもの

(b) among automatic control devices that are designed so that they are may be used in submersibles using navigation data, and, are servo controlled, those that fall under the following clauses 1. and 2.:

（一）　第一号の二又は第十四条第九号に該当する潜水艇に使用することができるもの

1. those that may be used in submersibles falling under item (i)-2 or Article 14, item (ix);

（二）　次のいずれかに該当するもの

2. those that fall under any of the following clauses:

１　水中のあらかじめ定められた点を中心とする半径一〇メートルの水柱内に潜水艇を移動することができるもの

i. those capable of moving submersibles to the inside of a column of water that has a radius of 10 meters with the predetermined center point in water;

２　水中のあらかじめ定められた点を中心とする半径一〇メートルの水柱内に潜水艇を保持することができるもの

ii. those capable of maintaining a submersible inside a column of water that has a radius of 10 meters with the predetermined center point in water;

３　海底又は海底下にあるケーブルに沿って移動する際に、ケーブルから一〇メートル以内に潜水艇を保持することができるもの

iii. those capable of maintaining a submersible within 10 meters of a cable when moving the submersible along a cable that is at the bottom of the sea or under the seabed;

ハ　潜水艇に使用することができるように設計した自動制御装置であって、航法データを使用し、かつ、サーボ制御方式であるもののうち、次の（一）及び（二）に該当するもの（ロに該当するものを除く。）

(c) among automatic control devices that are designed so that they may be used in submersibles which use navigation data, and, are servo controlled, those that fall under the following clauses 1. and 2. (excluding those falling under (b)):

（一）　第一号に該当する潜水艇に使用することができるように設計したもの

1. those that are designed so that they may be used in submersibles falling under item (i); and

（二）　次のいずれかに該当するもの

2. those that fall under any of the following clauses:

１　水中のあらかじめ定められた点を中心とする半径一〇メートルの水柱内に潜水艇を移動することができるもの

i. those capable of moving submersibles to the inside of a column having a radius of 10 meters having a preset center point in the water;

２　水中のあらかじめ定められた点を中心とする半径一〇メートルの水柱内に潜水艇を保持することができるもの

ii. those capable of maintaining a submersible inside a column that has a radius of 10 meters with the predetermided center point in water; or

３　海底又は海底下にあるケーブルに沿って移動する際に、ケーブルから一〇メートル以内に潜水艇を保持することができるもの

iii. those capable of maintaining a submersible inside a column of water within 10 meters from the cable when the submersible moves along a cable that is at the bottom of the sea or under the seabed;

ニ　光ファイバーを船体内に引き込むための耐圧殻の貫通金物

(d) through hull fitting with a pressure hull for pulling optical fibers into the hull of a vessel;

ホ　水中用の観測装置であって、次の全てに該当するもの

(e) observational equipment for underwater use which fall under all of the following clauses:

（一）　潜水艇に搭載して遠隔操作することができるように設計又は改造したもの

1. one that is designed or modified so that it may be loaded on a submersible and operated by remote control;

（二）　次のいずれかに該当する後方散乱による影響を減少させる機能を有するもの

2. one that has a function to reduce the effects of backscatter falling under

either of the following clauses:

１　レンジゲートイルミネーター

i. range gate illuminators; or

２　レーザー発振器を使用した装置

ii. devices using a laser oscillator;

五　水中用の照明装置であって、次のいずれかに該当するもの

(v) lighting equipment for underwater use which fall under either of the following sub-items:

イ　ストロボ法を用いたものであって、一回のフラッシュ当たりのエネルギーが三〇〇ジュールを超えるもののうち、一秒間に五回を超えて発光することができるもの

(a) among those using stroboscopic imaging for which the energy per flash exceeds 300 joules, those capable of emitting light more than five times per second; or

ロ　アルゴンのアークを用いたものであって、一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの

(b) those that use argon arcs which are designed so that they can be used at water depths exceeding 1,000 meters;

六　水中用のロボット（操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。）であって、次のいずれかに該当するもの

(vi) underwater robots (excluding operating robots and sequence robots) that fall under either of the following sub-items:

イ　外部物体に加えた力若しくはトルク、外部物体までの距離又は触覚を測定するセンサーからの情報を用いて制御するもの

(a) those that control by using the force or torque applied to an external object, information from a sensor that measures the distance to an external object, or that measures tactile sense; or

ロ　構造材にチタン合金又は繊維強化複合材料を用いたものであって、二五〇ニュートン以上の力又は二五〇ニュートンメートル以上のトルクで作業することができるもの

(b) those that use titanium alloy or fiber reinforced composite materials as structural materials, which are capable of operating under a force of more than 250 newtons, or at a torque of more than 250 newton meters;

七　潜水艇とともに使用することができるように設計した遠隔操作のマニピュレーター（関節を有するものに限る。）であって、次のいずれかに該当するもの

(vii) remote control manipulators (limited to those that have joints) that are designed so that they may be used together with submersibles, which fall under either of the following sub-items:

イ　外部物体に加えた力若しくはトルク又は外部物体との触覚を測定するセンサーからの情報を用いて制御するもの

(a) those that control by using the force or torque applied to an external

object, or the information from a sensor that measures tactile sense in contact with an external object; or

ロ　マスタースレーブ方式によって制御するものであって、動作自由度が五以上のもの

(b) those that control by using a master-slave system, with a degree of freedom of motion of 5 or more;

八　大気から遮断された状態で使用することができる動力装置であって、次のいずれかに該当するもの

(viii) power units that may be used in a condition isolated from atmosphere, which fall under any of the following sub-items:

イ　ブレイトンサイクルエンジン又はランキンサイクルエンジンであって、次のいずれかに該当する装置を有するもの

(a) brayton cycle engines or Rankine cycle engines that have a device that falls under any of the following clauses:

（一）　循環する排気から一酸化炭素、二酸化炭素及び微粒子を除去することができるように設計した装置

1. devices that are designed that they caqn remove carbon monoxide, carbon dioxide, and particles from the exhaust air that is circulating;

（二）　単原子で構成される気体を利用することができるように設計した装置

2. devices that are designed so that they can utilize monatomic gases;

（三）　一〇キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることができるように設計した防音装置若しくはエンクロージャ又は衝撃を緩和することができるように設計した装置

3. soundproofing devices or enclosures designed so that they can reduce underwater noise at frequencies of less than 10 kilohertz, or devices that are designed so that they can mitigate impacts;

（四）　反応生成物を圧縮又は燃料として再生することができ、反応生成物を貯蔵することができ、かつ、一〇〇キロパスカル以上の圧力下で反応生成物を排出することができるように設計した装置

4. devices that are designed to be capable of compressing reaction products or recycling them as fuel, storing the reaction products, and, discharging the reaction products at pressures of more than 100 kilopascals;

ロ　ディーゼルエンジンであって、次の（一）から（四）までのすべてに該当する装置を有するもの

(b) diesel engines that have devices falling under all of the following clauses 1. through 4.:

（一）　循環する排気から一酸化炭素、二酸化炭素及び微粒子を除去することができるように設計した装置

1. those that are designed so that they can remove carbon monoxide, carbon dioxide, and fine particles from exhaust air that is circulating;

（二）　単原子で構成される気体を利用することができるように設計した装置

2. those that are designed so that they can utilize monoatomic gases;

（三）　一〇キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることができるように設計した防音装置若しくはエンクロージャ又は衝撃を緩和することができるように設計した装置

3. soundproofing devices or enclosures that are designed so that they can reduce underwater noise at frequencies of less than 10 kilohertz, or devices that are designed so that they can mitigate impacts;

（四）　燃焼生成物を断続的に排出することができるように設計した装置

4. devices that are designed so that they can intermittently discharge combustion products;

ハ　出力が二キロワットを超える燃料電池であって、次のいずれかに該当する装置を有するもの

(c) fuel cells with an output exceeding 2 kilowatts which have a device that falls under any of the following clauses:

（一）　一〇キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることができるように設計した防音装置若しくはエンクロージャ又は衝撃を緩和することができるように設計した装置

1. soundproofing devices or enclosures that are designed so that they can reduce underwater noise at frequencies of less than 10 kilohertz or devices that are designed so that they can mitigate impacts;

（二）　反応生成物を圧縮又は燃料として再生することができ、反応生成物を貯蔵することができ、かつ、一〇〇キロパスカル以上の圧力下で反応生成物を排出することができるように設計した装置

2. devices that are designed so that they can compress reaction products or recycle them as fuel, store them, and, discharge them at the pressure of 100 kilopascals or more;

ニ　スターリングサイクルエンジンであって、次の（一）及び（二）に該当する装置を有するもの

(d) sterling cycle engines that have devices that fall under the following clauses 1. and 2.:

（一）　一〇キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることができるように設計した防音装置若しくはエンクロージャ又は衝撃を緩和することができるように設計した装置

1. soundproofing devices or enclosures that are designed so that they can reduce underwater noise at a frequency of less than 10 kilohertz, or devices that are designed so that they can mitigate impacts; and

（二）　一〇〇キロパスカル以上の圧力下で反応生成物を排出することができるように設計した装置

2. devices that are designed so that they can discharge reaction products at a pressure of 100 kilopascals or more;

九　削除

(ix) Deleted

十　船舶の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(x) components of a vessel which fall under any of the following sub-items:

イ　可変ピッチプロペラ又はそのハブであって、定格入力が三〇メガワットを超えるもの

(a) variable pitch propellers or their hubs with a rated input exceeding 30 megawatts;

ロ　内部液冷式の電気推進機関であって、出力が二・五メガワットを超えるもの

(b) internally liquid-cooled electric propulsion engines whose output exceeds 2.5 megawatts;

ハ　超電導式推進機関又は永久磁石を用いた電気推進機関であって、出力が〇・一メガワットを超えるもの

(c) superconductive propulsion engines or electric propulsion engines using a permanent magnet, which have an output exceeding 0.1 megawatts;

ニ　複合材料を用いた伝動軸装置であって、二メガワットを超える出力を伝達することができるもの

(d) transmission shaft devices using composite materials, which are capable of delivering output exceeding 2 megawatts;

ホ　スクリュープロペラ装置であって、プロペラから空気を噴き出すように設計したもの又はプロペラに空気を供給するように設計したもののうち、定格入力が二・五メガワットを超えるもの

(e) among screw propeller devices that are designed to discharge air from the propeller, or to supply air to the propeller, those with a rated output exceeding 2.5 megawatts;

ヘ　排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置であって、ディーゼルエンジン、ディーゼル発電機、ガスタービンエンジン、ガスタービン発電機、推進電動機又は減速装置から発生する五〇〇ヘルツ未満の周波数の音響又は振動を減少するもののうち、複合型の防音台からなり、かつ、中間のマスの重量がその上に設置される装置の重量の三〇パーセントを超えるもの

(f) among soundproofing devices that can be used on vessels that have a displacement of more than 1,000 tons, which reduce sound or vibration at a frequency of less than 500 hertz generated from diesel engines, diesel generators, gas turbine engines, gas turbine generators, propulsion electric motors, or reduction gears, those made of a composite sound isolation base, and, with the intermediate mass weight exceeding 30% of the weight of the device installed on them;

ト　スクリュープロペラの推進力の向上又はその水中ノイズの減少を図るために末広ノズル又は整流ベーンに関する技術を用いた装置であって、出力が二・五メガワットを超えるもの

(g) devices that use a divergent nozzle or technology related to a rectification vane to improve the driving force of the screw propeller, or to reduce

underwater noise, with an output exceeding 2.5 megawatts;

十一　推進器の模型の周辺の水流から生じるノイズを音場において計測するために設計した回流水槽であって、基準音圧が一マイクロパスカル及び周波数幅が一ヘルツの場合において、〇ヘルツ超五〇〇ヘルツ以下の周波数範囲での暗騒音が一〇〇デシベル未満のもの

(xi) a circulating water tank designed to measure the noise generated from the fow of water surrounding a model propulsion device in the sound field, with a background noise of less than 100 decibels in the frequency range of more than 0 hertz and 500 hertz or less when the reference sound pressure is 1 micropascal and the frequency width is 1 hertz;

十二　浮力材であって、次のイ及びロに該当するもの

(xii) buoyant materials that fall under the following sub-items (a) and (b):

イ　一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの

(a) those designed so that they may be used at water depths exceeding 1,000 meters; and

ロ　密度が五六一キログラム毎立方メートル未満のもの

(b) those for which the density is less than 561 kilograms per cubic meter;

十三　閉鎖回路式又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具

(xiii) self-contained diving equipment that is closed-circuit type or semi-closed circuit type;

十四　音波を利用して人の水中における活動を妨害する装置であって、当該利用する音波が二〇〇ヘルツ以下の周波数において音圧レベルが一九〇デシベル以上となるように設計したもの

(xiv) devices that disrupt a person's underwater activities by utilizing sound waves, which are designed to have a sound pressure level of 190 decibels or more at a frequency of the sound wave used are 200 hertz or less.

第十二条　輸出令別表第一の一三の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 12 The goods with specifications prescribed by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 13 of the Appended Table 1 of the Export Order are those that fall under any of the following items:

一　航空機用のガスタービンエンジンであって、次のいずれかに該当するもの

(i) gas turbine engines for aircraft, which fall under any of the following clauses:

イ　第二十五条第三項第二号イからトまで及びヌのいずれか、同項第三号若しくは同項第四号に該当するものの設計若しくは製造に必要な技術（プログラムを除く。）又は第二十七条第六項各号に該当するものの設計若しくは製造に必要な技術を用いたもの。ただし、次の（一）又は（二）のいずれかに該当するものを除く。

(a) those that use technology (excluding programs) necessary for designing or

manufacturing of things that fall under any of Article 25, paragraph (3), item (ii), clauses (a) through (g) and clause (j), item (iii) or item (iv) of that paragraph, or technology necessary for designing or manufacturing things that fall under the items of Article 27, paragraph (6); provided, however, that those falling under any of the following clauses 1. and 2. are excluded:

（一）　次の全てに該当するもの

1. those that fall under all of the following clauses:

１　本邦又は別表第二に掲げる地域の政府機関が証明したもの

i. those certified by a governmental organization of Japan or regions stated in the Appended Table 2; and

２　民生用有人航空機の動力供給用ガスタービンエンジンであって、当該エンジンを搭載する航空機に対して、本邦又は別表第二に掲げる地域の政府機関から次のいずれかの文書を発行されたもの

ii. gas turbine engine for supplying power to manned aircraft for civilian use, for which any of the following documents have been issued for aircraft that has the engine installed by a governmental organization of Japan or regions stated in the Appended Table 2:

一　型式証明

a. a type certificate; or

二　型式証明と同等の文書であって、国際民間航空機関の承認を受けたもの

b. a document equivalent to a type certificate, which has been approved by the International Civil Aviation Organization;

（二）　補助動力装置のために設計された航空機用ガスタービンエンジンであって、本邦又は別表第二に掲げる地域の政府機関が証明したもの

2. gas turbine engines for aircraft that are designed for auxiliary power units, which are certified by a governmental organization of Japan or regions stated in the Appended Table 2;

ロ　マッハ数が一を超える速度における巡航時間が三〇分を超えるように設計した航空機に使用するように設計したもの

(b) those that are designed to be used for aircraft that are designed so that the cruising time at a speed greater than Mach 1 exceeds 30 minutes;

二　液体燃料を使用するように設計した船舶用のガスタービンエンジン（船舶の発電若しくは推進に適合したガスタービンエンジンであって、産業用のもの又は航空機用ガスタービンエンジンから派生したものを含む。）であって、次のイ及びロに該当するもの又はそのために特に設計した組立品若しくは部分品

(ii) gas turbine engines for vessels which are designed to use liquid fuel (including gas turbine engines adaptable for power generation for or propulsion of vessels, for industrial use or have derived from gas turbine engines for aircraft), which fall under the following sub-items (a) and (b), or assemblies or components specially designed for them:

イ　国際規格ＩＳＯ三九七七／二（一九九七）が定める比較基準条件での定常状態

で動作する場合の最大連続出力が二四、二四五キロワット以上のもの

(a) those whose maximum continuous output is 24,245 kilowatts or more when they operate in a steady state under the standard reference conditions specified by the International Standards ISO 3977-2 (1997); and

ロ　液体燃料の使用時の補正燃料消費率が最大連続出力の三五パーセントにおいて一キロワット時当たり〇・二一九キログラム以下のもの

(b) those whose corrected fuel consumption rate when using liquid fuel is 0.219 kilograms per kWh or less at 35 percent of the maximum continuous output;

三　ガスタービンエンジンの組立品又はその部分品であって、第二十五条第三項第二号イからトまで及びヌのいずれか、同項第三号若しくは同項第四号に該当するものの設計若しくは製造に必要な技術（プログラムを除く。）又は第二十七条第六項各号に該当するものの設計若しくは製造に必要な技術を用いたもののうち、次のいずれかに該当する航空機用のガスタービンエンジンに使用するように設計したもの

(iii) among assemblies of gas turbine engines or their components which use technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing the things that fall under any of Article 25, paragraph (3), item (ii), sub-items (a) through (g) and sub-item (j), item (iii) or item (iv) of that paragraph, or technology necessary for designing or manufacturing the things that fall under the items of Article 27, paragraph (6), those designed to be used for gas turbine engines for aircraft that fall under either of the following sub-items:

イ　第一号に該当するもの

(a)) those that fall under item (i); or

ロ　設計した又は製造する地域が本邦若しくは別表第二に掲げる地域以外の地域であるもの又は特定できないもの

(b) those for which the region where they were designed or manufactured is a region other than Japan or a region stated in the Appended Table 2, or the region that cannot be specified;

四　宇宙空間用の飛しょう体若しくはその打上げ用の飛しょう体若しくはこれらの部分品又は準軌道用の飛しょう体であって、次のいずれかに該当するもの

(iv) flying objects to be used in outer space or flying objects for launching them or their components, or flying objects for sub-orbital flight, which fall under any of the following sub-items:

イ　宇宙空間用の飛しょう体の打上げ用の飛しょう体

(a) flying objects for launching flying objects to be used in outer space;

ロ　宇宙空間用の飛しょう体

(b) flying objects to be used in outer space;

ハ　宇宙空間用の飛しょう体のバス

(c) buses for flying objects to be used in outer space;

ニ　宇宙空間用の飛しょう体のペイロードであって、第六条第二号イ（一）４若し

くは第十六号、第八条第一号イ、第二号イ（二）若しくは第九号ハ若しくはホ、第九条第三号イ若しくはロ、第四号、第六号、第八号、第九号ハ、第九号の二、第十三号ニ、ホ、ル若しくはヲ又は第十号のいずれかに該当する貨物が組み込まれたもの

(d) payloads for flying objects to be used in outer space, in which the goods falling under any of Article 6, item (ii), sub-item (a), clause 1., iv. or item (xvi), Article 8, item (i), sub-item (a), item (ii), sub-item (a), clause 2. or item (ix), sub-item (c) or (e), Article 9, item (iii), sub-item (a) or (b), item (iv), item (vi), item (viii), item (ix), sub-item (a), item (ix)-2, item (xiii), sub-item (d), sub-item (e), sub-item (k), or sub-item (l), or item (x), are incorporated;

ホ　宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計した装置であって、次のいずれかの機能を有するもの

(e) devices that are designed to be loaded on a flying object to be used in outer space, which have any of the following functions:

（一）　遠隔指令又は遠隔測定データ処理

1. remote command or remote measurement data processing;

（二）　ペイロードデータ処理

2. payload data processing; or

（三）　姿勢及び軌道の制御

3. attitude and orbit control;

ヘ　準軌道用の飛しょう体

(f) flying objects for suborbital use;

四の二　航空機であって、宇宙空間用の飛しょう体の打上げ用の飛しょう体又は準軌道用の飛しょう体を空中で発射させるために特別に設計し、又は改造したもの

(iv)-2 aircraft specially designed or modified, for launching flying objects for launching flying objects to be used in outer space, or flying objects for sub-orbital craft in the air;

四の三　宇宙空間用の飛しょう体若しくはその打上げ用の飛しょう体の制御又はこれらの作動状態の監視のために必要な装置であって、地上に設置するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの（宇宙空間用の飛しょう体若しくはその打上げ用の飛しょう体の制御又はこれらの作動状態の監視に使用するように設計したものに限る。）

(iv)-3 among devices that are necessary for controlling flying objects for use in outer space or flying objects for launching them or for monitoring their operating state, which are designed to be installed on the ground, those which fall under any of the following clauses (limited to those designed to be used for controlling flying objects to be used in outer space or flying objects for launching them, or monitoring their operating state):

イ　無線遠隔制御装置又は無線遠隔測定装置であって、次のいずれかに掲げるデータ処理機能を有するように特に設計したもの

(a) wireless remote control devices, or radio telemetry equipment, which is designed to have a data processing function stated in any of the following clauses:

（一）　宇宙空間用の飛しょう体のバスの稼働状況を監視するための無線遠隔測定データのフレーム同期及びエラー訂正処理

1. frame synchronization and error correction processing for radio telemetry data for monitoring the operation status of buses for flying objects to be used in outer space; or

（二）　宇宙空間用の飛しょう体のバスを制御するために宇宙空間用の飛しょう体に送られる指令データのフォーマッティング処理

2. formatting processing for command data transmitted to a flying object to be used in outer space to control the buses for the flying object to be used in outer space;

ロ　宇宙空間用の飛しょう体の運用手順の検証用に特に設計したシミュレーター

(b) simulators specially designed to verify procedures for operating a flying object to be used in outer space;

五　次号に該当するものを内蔵する液体ロケット推進装置

(v) liquid rocket propulsion system that has the components falling under the following item incorporated;

六　液体ロケット推進装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(vi) components of liquid rocket propulsion systems which fall under any of the following sub-items:

イ　極低温用の冷却装置、デュワー瓶、ヒートパイプその他の極低温用装置であって、宇宙空間用の飛しょう体又はその打上げ用の飛しょう体に使用するように設計し、かつ、極低温状態にある液体の損失が一年間につき三〇パーセント未満のもの

(a) ultra low temperature cooling devices, Dewar vessels, heat pipes or other ultra low temperature devices, which are designed to be used in flying objects for use in outer space or for flying objects for launching them, and, which have a loss of liquied in an ultra low temperature condition is less than 30% per year;

ロ　極低温用容器又は閉サイクル冷却装置であって、零下一七三度以下にすることができるもののうち、宇宙空間用の飛しょう体、打上げ用の飛しょう体又はマッハ数が三を超える速度での巡航が可能な航空機に使用することができるように設計したもの

(b) among ultra low temperature containers or closed cycle cooling systems whose temperature can be kept at minus 173 degrees centigrade or less, those which are designed to be used in flying objects to be used in outer space, flying objects for launching, or aircraft that are capable of cruising at a speed exceeding Mach 3;

ハ　スラッシュ水素の貯蔵装置又は移送装置

(c) storage containers or supply systems for hydrogen slush;

ニ　一七・五メガパスカルを超える吐出圧のターボポンプ若しくはその部分品又は当該ターボポンプのためのガス発生器若しくはエクスパンダーサイクルタービン駆動装置

(d) turbine pumps or their components with a discharge pressure of more than 17.5 megapascals or gas generators or expander cycle turbine driving devices for those turbine pumps;

ホ　一〇・六メガパスカルを超える推力発生器又はそのノズル

(e) propulsion generators that have a thrust exceeding 10.6 megapascals, or their nozzles;

ヘ　推進薬貯蔵装置であって、毛細管現象を利用したもの又はフレキシブルブラダーを用いたもの

(f) propellant storage unit that utilizes capillary action, or uses flexible bladders;

ト　液体燃料噴射器であって、個々のオリフィスの面積が〇・一一四平方ミリメートル以下のもの

(g) liquid fuel injection devices for which the area of each orifice is 0.114 square millimeters or less; or

チ　炭素及び炭素繊維を用いた複合材料により一体成形された推力室又はイグジットコーンであって、密度が一・四グラム毎立方センチメートルを超えるもののうち、引張強さが四八メガパスカルを超えるもの

(h) among thrust chambers or exit cones that are integrally formed by using a composite material of carbon and carbon fibers, whose density exceed 1.4 grams per cubic centimeter, those for which the tensile strength is more than 48 megapascals;

七　固体ロケット推進装置であって、次のいずれかに該当するもの

(vii) solid rocket propulsion systems that fall under any of the following sub-items:

イ　全力積が一・一メガニュートン秒を超えるもの又は燃焼器内の圧力を七メガパスカルにした状態でノズルの出口圧力を海面レベルの大気圧にした時の比推力が二・四キロニュートン秒毎キログラム以上のもの

(a) those whose total impulse exceeds 1.1 meganewtons seconds, or whose specific impulse is 2.4 kilonewton seconds per kilogram or more when the nozzle outlet pressure is the atmospheric pressure at the sea level in a state the pressure inside the combustor is brought to 7 megapascals;

ロ　ステージのマスフラクションが八八パーセントを超えるものであって、推進薬固体比率が八六パーセントを超えるもの

(b) those in which mass fraction of a stage exceeds 88% and the propellant solid ratio exceeds 86%;

ハ　次号に該当するものを内蔵したもの

(c) those that has the components falling under the following item

incorporated; or

ニ　断熱材と推進薬を接合するためのものであって、推進薬の強度以上の機械的接合強度を得るため又は固体推進薬とモータケースの断熱材の間の化学的移行に対するバリヤーとするためにダイレクトボンディングモータ設計法を用いたもの

(d) those for joining insulating materials and propellants, which use a direct bonding motor designing method to obtain a mechanical bonding strength that is greater than the strength of the propellant, or to use as a barrier against the chemical migration between the solid propellant and the insulating material of the motor case;

八　固体ロケット推進装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(viii) components for solid rocket propulsion systems, which fall under any of the following sub-items:

イ　断熱材と推進薬を接合するためのものであって、推進薬の強度以上の機械的接合強度を得るため又は固体推進薬とモータケースの断熱材の間の化学的移行に対するバリヤーとするためにライナーを用いたもの

(a) those for joining insulating materials and propellants, which use liners to obtain a mechanical bonding strength that is greater than the strength of the propellant, or to use as a barrier against the chemical migration between the solid propellant and the insulating material for the motor case;

ロ　フィラメントワインディング法で成形された複合材を用いたモータケースであって、直径が〇・六一メートルを超えるもの又は構造効率比が二五キロメートルを超えるもの

(b) motor cases that use composite materials formed by the filament winding method, which have a diameter exceeding 0.61 meters, or with a structural efficiency ratio of more than 25 km;

ハ　ノズルであって、推力が四五キロニュートンを超えるもの又はノズルのスロートの侵食率が〇・〇七五ミリメートル毎秒未満のもの

(c) nozzles for which the thrust exceeds 45 kilonewtons, or the nozzle throat erosion rate is less than 0.075 millimeters per second;

ニ　可動ノズル又は二次噴射推力方向制御装置であって、次のいずれかに該当するもの

(d) movable nozzle or secondary injection trust vector control device, which falls under any of the following clauses:

（一）　推力方向の偏向範囲の絶対値が五度を超えるもの

1. those for which the absolute value for the deflection area in the thrust vector exceeds 5 degrees;

（二）　推力方向を変化させる際の角速度が二〇度毎秒以上のもの

2. those for which the angular velocity in changing the thrust vector is greater than 20 degrees per second;

（三）　推力方向を変化させる際の角加速度が四〇度毎秒毎秒以上のもの

3. those for which the angular acceleration in changing the thrust vector is greater than 40 degrees per second squared;

九　ハイブリッドロケット推進装置であって、次のいずれかに該当するもの

(ix) hybrid rocket propulsion system that falls under either of the following sub-items:

イ　全力積が一・一メガニュートン秒を超えるもの

(a) those whose total impulse exceeds 1.1 meganewton seconds; or

ロ　出口が真空になっている状態での推力が二二〇キロニュートンを超えるもの

(b) those whose thrust when the outlet is in a vacuum state exceeds 220 kilonewtons;

十　打上げ用の飛しょう体若しくはその推進装置又は宇宙空間用の飛しょう体の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(x) components for flying objects used for launching or their propulsion devices, or for flying objects to be used in outer space, which fall under any of the following sub-items:

イ　打上げ用の飛しょう体の部分品（ノーズコーン以外のものにあっては、重量が一〇キログラムを超えるものに限る。）であって、次のいずれかに該当するもの

(a) components of flying objects used for launching (for components other than nose cones, limited to those that exceed 10 kilograms in weight), which fall under any of the following clauses:

（一）　第四条第十五号ホに該当する繊維からなる複合材料又は同条第十三号若しくは第十四号ロに該当する樹脂

1. composite materials composed of the fiber falling under Article 4, item (xv), clause (e), or resins falling under item (xiii) or item (xiv), clause (b) of that Article;

（二）　金属マトリックス複合材料であって、次のいずれかで補強されたもの

2. metal matrix composite materials that are reinforced by any of the following things:

１　第四条第十二号に該当する物質

i. substances falling under Article 4, item (xii);

２　第四条第十五号に該当する繊維

ii. fibers falling under Article 4, item (xv); or

３　第四条第七号イに該当するアルミニウムの化合物

iii. aluminum compounds falling under Article 4, item (vii), sub-item (a);

（三）　第四条第十二号に該当するセラミックマトリックス複合材料

3. ceramic matrix composite materials falling under Article 4, item (xii);

ロ　打上げ用の飛しょう体の推進装置の部分品であって、第五号、第七号又は前号のいずれかに該当する推進装置に使用するように設計したものであって、次のいずれかを用いたもの

(b) components of propulsion devices of flying objects for launching which are designed to be used for propulsion devices falling under either item (v) or

(vii), or any of the preceding items, which use any of the following things:

（一）　第四条第十五号ホに該当する繊維又は同条第十三号若しくは第十四号ロに該当する樹脂

1. fibers falling under Article 4, item (xv), sub-item (e) or resins falling under item (xiii) or item (xiv), sub-item (b) of that Article;

（二）　金属マトリックス複合材料であって、次のいずれかで補強されたもの

2. metal matrix composite materials reinforced by any of the following things:

１　第四条第十二号に該当する物質

i. substances falling under Article 4, item (xii);

２　第四条第十五号に該当する繊維

ii. fibers falling under Article 4, item (xv); or

３　第四条第七号イに該当するアルミニウムの化合物

iii. aluminum compounds falling under Article 4, item (vii), sub-item (a);

（三）　第四条第十二号に該当するセラミックマトリックス複合材料

3. ceramic matrix composite materials falling under Article 4, item (xii);

ハ　宇宙空間用の飛しょう体の部分品であって、構造体の動的応答又はねじれを能動的に制御するもの

(c) components for flying objects to be used in outer space, which actively control dynamic response or torsion of the structure ;

ニ　液体パルスロケットエンジンであって、推力重量比が一キロニュートン毎キログラム以上のもののうち、応答時間が〇・〇三〇秒未満のもの

(d) among liquid pulse rocket engines whose thrust weight ratio is 1 kilonewton per kilogram or more, those for which the response time is less than 0.030 seconds;

十の二　無人航空機又はその部分品若しくは附属装置であって、次のイ又はロに該当するもの

(x)-2 unmanned aircrft or its components or auxiliary equipment, which fall under the following sub-item (a) or (b):

イ　無人航空機であって、操縦者の視覚に頼ることなく制御された飛行を行うよう設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

(a) unmanned aircraft that is designed to make a controlled flight without depending on the pilot's sense of sight, which fall under any of the following clauses:

（一）　次の１及び２に該当するもの

1. one that falls under the following clauses i. and ii.:

１　最大航続時間が三〇分以上一時間未満のもの

i. one whose maximum cruising time is 30 minutes or more and less than 1 hour; and

２　一時間当たり四六・三キロメートル（二五ノット）の速度以上の突風の中で離陸し安定した制御飛行が可能なもの

ii. one capable of taking off in a gust of wind with a speed of 46.3 kilometers (25 knots) per hour or more and make a stable controlled flight;

（二）　最大航続時間が一時間以上のもの

2. one whose maximum cruise time is 1 hour or more;

ロ　無人航空機の部分品又は附属装置であって、次のいずれかに該当するもの

(b) components or auxiliary equipment of unmanned aircraft, which fall under any of the following clauses:

（一）　削除

1. Deleted

（二）　削除

2. Deleted

（三）　有人航空機をイに該当する無人航空機に変換するように設計したもの

3. those designed to convert manned aircraft into unmanned aircraft that fall under sub-item (a);

（四）　無人航空機を一五、二四〇メートルの高度を超えて飛行させることができるように設計又は改造された空気吸入式のレシプロエンジン又は内燃式のロータリーエンジン

4. air-breathing reciprocating engines or internal combustion rotary engines, designed or modified to propel unmanned aircraft at an altitude excedding 15,240 meters;

十一　次のいずれかに該当する装置又は工具（型を含む。）

(xi) devices or tools (including molds) that fall under any of the following sub-items:

イ　超合金用に設計した一方向性凝固又は単結晶の鋳造のための装置

(a) devices that are for super alloys designed for unidirectional solidification or casting of single crystals;

ロ　ガスタービンエンジンのブレード、ベーン又はチップシュラウドを製造するために設計した耐熱金属製又はセラミック製の鋳造用の工具であって、次のいずれかに該当するもの

(b) tools for casting made of refractory metal or ceramics which are designed for manufacturing blades, vanes, or tip shrouds for gas turbine engines, which fall under any of the following tools:

（一）　コア

1. cores;

（二）　シェル

2. shells; or

（三）　（一）又は（二）を組み合わせたもの

3. a combination of 1. or 2.;

ハ　超合金用に設計した一方向性凝固又は単結晶の積層造形を行う装置

(c) devices designed for super alloys which perform unidirectional solidification or additive manufacturing of single crystals;

十二　実時間で制御する装置、計測器（センサーを含む。）又は自動的にデータを収集し、解析する装置であって、次のイ及びロに該当するもの

(xii) devices that perform real time control, measuring instruments (including sensors), or devices that automatically collect and analyze data, which fall under the following sub-items (a) and (b):

イ　ガスタービンエンジン又はその部分品を設計するために特に設計したもの

(a) those specially designed for developing gas turbine engines or their components; and

ロ　第二十五条第三項第三号又は第四号に該当するものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）を用いたもの

(b) those that use technologies (excluding programs) necessary for designing or manufacturing those falling under Article 25, paragraph (3), item (iii) or (iv);

十三　チップにおける周速が三三五メートル毎秒を超えるものであって、五〇〇度を超える温度において運転できるように設計したガスタービンエンジンのブラシシールの製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品

(xiii) devices for manufacturing brush seals for gas turbine engines whose tip peripheral speed exceeds 335 meters per second and are designed so that they can be operated at a temperature exceeding 500 degrees centigrade or their testing devices, or components;

十四　金属間化合物、超合金又はチタンからなるガスタービンエンジンの翼部とディスク部を固相接合するための工具

(xiv) tools for performing solid phase bonding of the wing part and disk part of gas turbine engines made of intermetallic compounds, super alloys, or titanium;

十五　次のいずれかに該当する風洞又は装置とともに使用するように設計したものであって、実時間で制御する装置、計測器（センサーを含む。）又は自動的にデータを収集し、解析する装置

(xv) devices designed to be used together with wind tunnels or devices that fall under any of the following clauses, which perform real time control, measuring instruments (including sensors), or devices that automatically collect and analyze data:

イ　マッハ数が一・二以上の速度の状態を作ることができる風洞

(a) wind tunnels that are capable of creating a velocity condition of Mach 1.2 or more;

ロ　マッハ数が五を超える流れの環境をシミュレートすることができる装置

(b) devices that are capable of simulating flow environments exceeding Mach 5;

ハ　二五、〇〇〇、〇〇〇を超えるレイノルズ数の流れをシミュレートすることができる風洞又は装置。ただし、試験用のモデルが二次元断面のものに限られるものを除く。

(c) wind tunnels or devices which are capable of simulating the flow for a Reynolds number exceeding 25,000,000; provided, however, this excludes test models that are restricted to two-dimensional sections;

十六　音響振動試験装置であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその石英加熱器

(xvi) acoustic vibration testing devices that fall under all of the following sub-items (a) through (c):

イ　基準音圧を二〇マイクロパスカルとしたときの音圧が一六〇デシベル以上のもの

(a) those whose sound pressure is greater than 160 decibels when the standard sound pressure is 20 micropascals;

ロ　定格出力が四キロワット以上のもの

(b) those with the rated output of 4 kilowatts or more; and

ハ　試験室の温度が一、〇〇〇度を超えるもの

(c) those for which the temperature of the testing room exceeds 1,000 degrees centigrade;

十七　非破壊検査技術を用いてロケットモータを検査するための装置

(xvii) devices for testing rocket motors by using a non-destructive testing technique;

十八　よどみ点における温度が五六〇度を超える流れの壁面摩擦を直接計測することができるように設計した変換器

(xviii) converters that are designed so that they can directly measure the wall friction of a flow in which the temperature at the stagnation point exceeds 560 degrees centigrade;

十九　ガスタービンエンジンの回転部分に用いられる部分品であって粉末冶金によって製造されるもののうち極限引張強さの六〇パーセント以上の応力を加えた状態で六〇〇度以上の温度で使用することができるものを製造するための工具（粉体を製造するための工具を除く。）

(xix) tools for manufacturing components that are used for the rotating parts of a gas turbine engine and manufactured by powder metallurgy, which are usable in the state a stress of 60% or more of the ultimate tensile strength is applied at a temperature of 600 degrees centigrade or more (excluding tools for manufacturing powder);

二十　第十号の二に該当するものの製造用の装置

(xx) devices for manufacturing the things falling under item (x)-2.

第十三条　輸出令別表第一の一四の項（一）の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 13 (1) The goods with specifications prescribed by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 14 (i) of the Appended Table 1 of the Export Order are to fall under either of the following items:

一　粒子が球形で、かつ、その径が六〇マイクロメートル以下のアルミニウムの粉であって、アルミニウムの純度が九九パーセント以上のものからなるもの

(i) aluminum powder whose particles are globular, and, with a diameter of 60 micrometers or less, which has an aluminum purity of 99% or more;

二　粒子の径が三マイクロメートル以下の鉄（水素で酸化鉄を還元する方法を用いて製造したものに限る。）の粉であって、鉄の純度が九九パーセント以上のものからなるもの

(ii) iron powder with a particle diameter of 3 micrometers or less (limited to those manufactured using a method of reducing iron oxide using hydrogen), which has an iron purity of 99% or more.

2　輸出令別表第一の一四の項（二）の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

(2) The goods specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 14 (ii) of the Appended Table 1 of the Export Order are those that fall under any of the following items:

一　火薬又は爆薬の主成分となる物質であって、次のいずれかに該当するもの（共結晶したものを含む。）

(i) substances that will be the main components of gunpowder or explosive compounds, which fall under any of the following sub-items (including those that are co-crystallized):

イ　硝酸トリアミノグアニジン

(a) anidine triamine nitrate;

ロ　チタニウムサブヒドリドであって、化学量論比が〇・六五以上一・六八以下のもの

(b) titanium subhydride with a chemically correct mixture ratio of 0.65 or more and 1.68 or less;

ハ　ジニトログリコルリル

(c) dinitroglycolyl;

ニ　三―ニトロ―一・二・四―トリアゾール―五―オン

(d) 3-nitro-1,2,4-triazole-5-one;

ホ　削除

(e) Deleted

ヘ　削除

(f) Deleted

ト　硝酸ヒドロキシルアンモニウム

(g) hydroxylammonium nitrate;

チ　過塩素酸ヒドロキシルアンモニウム

(h) hydroxyl ammonium perchlorate;

リ　二―（五―シアノテトラゾレート）ペンタアミンコバルト（ＩＩＩ）パークロレート

(i) 2-(5-cyanotetrazolate) pentaamine cobalt (III) perchlorate;

ヌ　シスービス（五―ニトロテトラゾレート）テトラアミンコバルト（ＩＩＩ）パークロレート

(j) cis-bis (5-nitrotetrazolate) tetra amine cobalt (III) perchlorate;

ル　アミノジニトロベンゾフロキサン

(k) amino dinitrobenzofuroxan;

ヲ　ジアミノジニトロベンゾフロキサン

(l) diamino dinitrobenzofuroxane;

ワ　ビス（２・２・２―トリニトロエチル）ニトラミン

(m) bis (2,2,2-trinitro ethyl) nitramine; or

カ　ジヒドロキシルアンモニウム＝五・五′―ビステトラゾール―一・一′―ジオラート（ＴＫＸ）

(n) dihydroxyl ammonium 5,5'-bistetrazole-1,1'-diolate (TKX);

二　火薬若しくは爆薬の添加剤又は前駆物質となる物質であって、次のいずれかに該当するもの（共結晶したものを含む。）

(ii) substances that will be additives or precursors of gunpowder or explosive compounds, which fall under any of the following sub-items (including those that are co-crystallized):

イ　アジドメチルメチルオキセタン又はその重合体

(a) azide methyl methyl oxetane or its polymer;

ロ　塩基性サリチル酸銅

(b) basic copper salicylate;

ハ　サリチル酸鉛

(c) lead salicylate;

ニ　削除

(d) Deleted

ホ　削除

(e) Deleted

ヘ　ビス（二・フルオロ―二・二―ジニトロエチル）フォルマール

(f) bis (2,fluoro-2,2-dinitroethyl) formal;

ト　ビス（二―ヒドロキシエチル）グリコルアミド

(g) bis (2-hydroxyethyl) glycol amide;

チ　ビス（二―メチルアジリジニル）メチルアミノホスフィンオキシド

(h) bis (2-methyl aziridinyl) methyl amino phosphine oxide;

リ　３・３―ビス（アジドメチル）オキセタン又はその重合体

(i) 3,3-bis (azidomethyl) oxetane or its polymer;

ヌ　３・３―ビス（クロロメチル）オキセタン

(j) 3,3- bis (chloromethyl) oxetane;

ル　ブタジエンニトリルオキシド

(k) butadiene nitrile oxide;

ヲ　一・二・三―ブタントリオールトリナイトレート

(l) 1,2,3-butanetriol trinitrate;

ワ　ジニトロアゼチジンターシャリーブチル塩
(m) dinitro azetidine tertiary butyl salt;
カ　ニトロ基、アジド基、ニトレート基、ニトラザ基又はジフルオロアミノ基を有する高エネルギーモノマー、可塑剤及び重合体
(n) high energy monomers that have a nitro group, azide group, nitrate group, nitraza group or difluoro amino group, a plasticizer, and a polymer;
ヨ　ポリ―二・二・三・三・四・四―ヘキサフルオロペンタン―一・五―ジオールフォルマール
(o) poly-2,2,3,3,4,4-hexafluoro pentane-1,5-diol formal;
タ　ポリ―二・四・四・五・五・六・六―ヘプタフルオロ―二―トリフルオロメチル―三―オキサヘプタン―一・七―ジオールフォルマール
(p) poly-2,4,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-trifluoro methyl-3-oxaheptane-1,7-diol formal;
レ　グリシジルアジドの重合体の誘導体
(q) derivatives of polymers of glycidyl azide;
ソ　ヘキサベンジルヘキサアザイソウルチタン
(r) hexabenzylhexaazaisowurtzitane;
ツ　超微粉酸化第二鉄であって、表面積が一グラム当たり二五〇平方メートルを超え、かつ、粒子の径の平均が〇・〇〇三マイクロメートル以下のもの
(s) ultrafine powdered ferric oxide with the surface area exceeding 250 square meters per gram, and, whose average diameter of particulars is 0.003 micrometers or less;
ネ　ベーターレゾルシン酸鉛又はベーターレゾルシン酸銅
(t) beta-resorcylic acid lead or beta-resorcylic acid copper;
ナ　すず酸鉛
(u) lead stannate;
ラ　マレイン酸鉛
(v) lead maleate;
ム　クエン酸鉛
(w) lead citrate;
ウ　ベーターレゾルシン酸鉛又はサリチル酸鉛の鉛―銅のキレート
(x) chelate of beta lead resorcinate or lead-copper lead salicylate;
ヰ　ニトラトメチルメチルオキセタン又は三―ニトラトメチル―三―メチルオキセタンの重合体
(y) polymers of nitrate methyl methyl oxetane or 3-nitrate methyl-3-methyl oxetane;
ノ　三―ニトラザ―一・五―ペンタンジイソシアネート
(z) 3-nitraza-1,5-pentane diisocyanate;
オ　推進薬の添加剤となる有機金属のカップリング剤
(aa) coupling agents for organic metal which are additive for propellant;
ク　ポリシアノジフルオロアミノエチレンオキシド

(bb) polycyano difluoroamino ethylene oxide;

ヤ　ポリグリシジルニトレート又はニトラトメチルオキシランの重合体

(cc) polymers of polyglycidyl nitrate or nitrate methyl oxylane;

マ　ポリニトロオルトカーボネート

(dd) polynitro ortho carbonate;

ケ　プロピレンイミン

(ee) propylene imine;

フ　テトラアセチルジベンジルヘキサアザイソウルチタン

(ff) tetraacetyl benzyl hexaazoisoultrane;

コ　シアノエチル化ポリアミン（第三条第七号ツに掲げるものを除く。）又はシアノエチル化ポリアミンの塩

(gg) cyanoethylated polyamine (excluding those stated in Article 3, item (vii), sub-item (s)), or cyanoethylated polyamine salts;

エ　グリシドールを付加したシアノエチル化ポリアミン（第三条第七号ソに掲げるものを除く。）又はグリシドールを付加したシアノエチル化ポリアミンの塩

(hh) cyanoethylated poly amine with glycydol added (excluding those stated in Article 3, item (vii), sub-item (r));

テ　トリス―一―（二―メチル）アジリジニルホスフィンオキシドの誘導体

(ii) derivatives of tris-1-(2-methyl) aziridinyl phosphine oxide;

ア　一・二・三―トリス（一・二―ビス（ジフルオロアミノ）エトキシ）プロパン又はトリスビノキシプロパンの付加物

(jj) additives of 1,2,3-tris (1,2-bis (difluoro amine) ethoxy) propane or tris binoxypropane;

サ　一・三・五―トリクロロベンゼン

(kk) 1,3,5-trichlorobenzene;

キ　一・二・四―ブタントリオール

(ll) 1,2,4-butane triol;

ユ　一・三・五・七―テトラアセチル―一・三・五・七―テトラアザシクロオクタン

(mm) 1,3,5,7-tetraacetyl-1,3,5,7-tetraazocyclooctane;

メ　一・四・五・八―テトラアザデカリン

(nn) 1,4,5,8-tetraazadecaline; or

ミ　低分子量（分子量が一〇、〇〇〇以下のものをいう。）で、かつ、アルコール官能基を有するポリエピクロロヒドリン、ポリエピクロロヒドリンジオール又はポリエピクロロヒドリントリオール

(oo) polyepichlorohydrin, polyepichlorohydrin diol, or polyepichlorohydrin triol that has a low-molecular weight (meaning those with a molecular weight of 10,000 or less), and, has alcohol functional groups.

3　輸出令別表第一の一四の項（三）の経済産業省令で定める仕様のものは、出力が三七・三キロワット以上のディーゼルエンジンであって、非磁性材料で構成されている部分の重量が全重量の七五パーセント以上のもの又はその部分品とする。

(3) The goods with specifications prescribed by Order of the Ministry, Trade and Industry referred to in row 14 (iii) of the Appended Table 1 of the Export Order are diesel engines with an output of 37,3 kilowatts or more for which the weight of the parts composed of non-magnetic materials is more than 75% of the total weight, or their components.

4　輸出令別表第一の一四の項（五）の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

(4) The goods with specifications prescribed by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 14 (v) of the Appended Table 1 of the Export Order are those that fall under any of the following items:

一　閉鎖回路式自給式潜水用具又はその部分品

(i) closed-circuit type self-contained diving equipment, or their components;

二　半閉鎖回路式自給式潜水用具又はその部分品

(ii) semi-closed circuit type self-contained diving equipment, or their components; or

三　自給式潜水用具の部分品であって、開放回路式自給式潜水用具を閉鎖回路式自給式潜水用具又は半閉鎖回路式自給式潜水用具に変換するために使用するように設計したもの

(iii) components of self-contained diving equipment which are designed to be used in converting open circuit type self-contained diving equipment to closed circuit self-contained diving equipment or semi-closed circuit self-contained diving equipment.

5　輸出令別表第一の一四の項（七）の経済産業省令で定める仕様のものは、ロボット（操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。以下この項において同じ。）若しくはロボット用の制御装置若しくはエンドエフェクターであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品（ロボット用のエンドエフェクターであるものを除く。）とする。

(5) The goods with specifications prescribed by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 14 (vii) of the Appended Table 1 of the Export Order are robots (excluding operating robots and sequence robots; the same applies below in this paragraph) or control devices or end effectors used for robots, which fall under either of the following items, or their components (excluding end effectors for robots):

一　引火点が五六六度を超える圧力油を使用することができるように設計したもの

(i) those that are designed so that they can use pressure oil with the ignition point exceeding 566 degrees centigrade; or

二　電磁パルスによる影響を防止するように設計したもの

(ii) those that are designed to prevent the effect of electromagnetic pulses.

6　輸出令別表第一の一四の項（九）の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

(6) The goods with specifications prescribed by Order of the Ministry of Economy,

Trade and Industry referred to in row 14 (ix) of the Appended Table 1 of the Export Order are to fall under any of the following items:

一　ブロモベンジルシアニド

(i) bromobenzyl cyanide;

二　クロロベンザルマロノニトリル

(ii) chlorobenzal malononitrile;

三　クロロアセトフェノン

(iii) chloroacetophenone;

四　ジベンズ―（ｂ・ｆ）―一・四―オキサゼビン

(iv) dibenzo (b,f)-1,4-oxazebine;

五　N―ノナノイルモルホリン

(v) N-Nonanoylmorpholine;

六　ジフェニルクロロアルシン

(vi) diphenyl chloroarsine;

七　ジフェニルアミンクロロアルシン（アダムサイト）

(vii) diphenyl amine chloroarsine (adamsite);

八　ジフェニルシアノアルシン

(viii) diphenyl cyanoarsine; or

九　前各号のいずれかに該当する物質の散布、防護、探知若しくは識別のための装置又はその部分品

(ix) equipment for scattering, protecting, detecting, or identifying substances that fall under any of the preceding items, or their components.

7　輸出令別表第一の一四の項（十）の経済産業省令で定める仕様のものは、簡易爆発装置を除去又は処理するために特に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品

(7) The goods with specifications prescribed by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 14 (x) of the Appended Table 1 of the Export Order are devices specially designed to remove or dispose of improvised explosive devices, which fall under either of the following things, or their components or accessories:

一　遠隔操作が可能な車両であるもの

(i) those that are vehicles for which remote control is possible; or

二　投射物により簡易爆発装置の作動を防止するもの

(ii) those that prevent the operation of improvised explosive devices by projectiles.

8　爆発物を自動的に探知し、又は識別するように設計した電子式の装置であって、表面弾性波の測定、イオン移動度分光分析、微分型移動度分析又は質量分析のいずれかの方法によって爆発物の痕跡を探知するもの（濃度一ピーピーエム未満の蒸気又は質量一ミリグラム未満の固体若しくは液体の探知が可能なものに限り、専ら実験用機器として利用することを目的として設計したもの又は歩行して当該装置を通過する対象が当該装置に接触することなく爆発物を探知するように設計したものを除く。）

(8) Electronic equipment designed to automatically detect or identify explosives, which detects traces of explosives by one of the methods among the methods of measuring the surface acoustic wave, ion mobility spectrometry, differential mobility spectrometry, or mass spectrometry (limited to one capable of detecting vapor with a density of less than 1 ppm, or solid or liquid with a mass of less than 1 mg, and excluding one designed for the purpose of exclusively using as laboratory equipment, or designed to detect explosives without having the subject that passing through it on foot to have any contact with it).

第十四条　輸出令別表第一の一五の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

Article 14 The goods with specifications prescribed by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 15 of the Appended Table 1 of the Export Order are those that fall under any of the following items:

一　第四条第十五号ハ又はニに該当する繊維を用いて製造した成型品（半製品を含む。）であって、有機物をマトリックスとするもの

(i) molded products that are manufactured using fibers falling under Article 4, item (xv), sub-item (c) or (d) , with a matrix of organic matters;

二　電波若しくは赤外線の吸収材又は導電性高分子であって、次のいずれかに該当するもの

(ii) radio wave or infrared ray absorbers, or conductive polymers, which fall under any of the following sub-items:

イ　電波の吸収材として使用するように特に設計したものであって、周波数が二〇〇メガヘルツ超三テラヘルツ未満のもの。ただし、次のいずれかに該当するものであって、塗料に混入したときに吸収性能を備える磁性材料でないものを除く。

(a) those specially designed to be used as radio wave absorbers which have a frequency of more than 200 megahertz and less than 3 terahertz; provided, however, that this excludes those falling under any of the following absorbers which are not magnetic materials having absorption performance when mixed into coating materials:

（一）　磁性を有していない繊維状の吸収材

1. non-magnetic fibrous absorbers;

（二）　磁気損失により電波を吸収するものでないものであって、入射面が平面状でない吸収材

2. absorbers that do not absorb radio waves through magnetic loss, with entrace face that is not planar;

（三）　平面状の吸収材であって、次の１から３までのすべてに該当するもの

3. planar absorbers that fall under all of the following clauses i. through iii.:

１　次のいずれかに該当するものからなるもの

i. absorbers made of any of the following materials:

一　炭素を含有するプラスチックの発泡体を用いた材料又は有機物を用いた材料であって、次のイ及びロに該当するもの

a. materials that use plastic foams containing carbon, or organic matters, which fall under the following clauses 1 and 2:

イ　吸収率が最大である電波の周波数を中心としたプラスマイナス一五パーセントの周波数範囲以外の周波数において測定した当該吸収材の電波の反射率が金属板の電波の反射率の五パーセント以上のもの

1 those that have a radio wave reflectance of 5% or more of the electric wave reflectance of a metal plate measured at a frequency other than the frequency range of plus or minus 15% centered on the radio wave frequency in which the absorption rate is maximum;

ロ　一七七度を超える温度で使用することができないもの

2 those that cannot be used at a temperature exceeding 177 degrees centigrade;

二　セラミックを用いた材料であって、次のイ及びロに該当するもの

b. materials that use ceramics which fall under the following clauses 1 and 2:

イ　吸収率が最大である電波の周波数を中心としたプラスマイナス一五パーセントの周波数範囲以外の周波数において測定した当該吸収材の電波の反射率が金属板の電波の反射率の二〇パーセント以上のもの

1 those that have a radio wave reflectance of 20% or more of the electric wave reflectance of a metal plate measured at a frequency other than the frequency range of plus or minus15% centered on the radio wave frequency in which the absorption rate is maximum;

ロ　五二七度を超える温度で使用することができないもの

2 those that cannot be used at a temperature exceeding 527 degrees centigrade;

２　引張強さが七メガニュートン毎平方メートル未満のもの

ii. absorbers with a tensile strength of less than 7 meganewtons per square meter;

３　圧縮強さが一四メガニュートン毎平方メートル未満のもの

iii. absorbers with a compressive strength of less than 14 meganewtons per square meter;

（四）　焼結したフェライトからなる平面状の吸収材であって、次の１及び２に該当するもの

4. planar absorbers made of sintered ferrites which fall under the following clauses i. and ii.:

１　比重が四・四を超えるもの

i. those with the specific gravity exceeding 4.4;

２　二七五度を超える温度で使用することができないもの

ii. those that cannot be used at a temperature exceeding 275 degrees centigrade;

（五）　連続気泡発泡体のプラスチック材料から製造された平面状の吸収材であって、密度が〇・一五グラム毎立方センチメートル以下のもののうち、磁気損失により電波を吸収するものでないもの

5. among planar absorbers manufactured from plastic materials of open-cell foams which have a density of 0.15 grams per cubic centimeter or less, those that do not absorb radio waves through magnetic loss;

ロ　近赤外線の吸収材として使用するように特に設計したものであって、波長が八一〇ナノメートル超二、〇〇〇ナノメートル未満のもの（周波数が一五〇テラヘルツ超三七〇テラヘルツ未満のものをいう。）のうち、可視光を透過しないもの

(b) among those specially designed to be used as absorbent for near-infrared rays whose wavelength is more than 810 nanometers and less than 2,000 nanometers (meaning those whose frequency is more than 150 terahertz and less than 370 terahertz), those that do not transmit visible light;

ハ　導電性高分子であって、体積導電率が一〇キロジーメンス毎メートルを超えるもの又は表面抵抗率が一〇〇オーム未満のもののうち、次のいずれかの重合体からなるもの

(c) among those that are conductive polymers with volume conductivity exceeding 10 kilosiemens per meter, or surface resistivity of less than 100 ohms, those that are composed of any of the following polymers:

（一）　ポリアニリン

1. polyaniline;

（二）　ポリパイロール

2. polypyrole;

（三）　ポリチオフェン

3. polythiophene;

（四）　ポリフェニレンビニレン

4. polyphenylene vinylene; or

（五）　ポリサイニレンビニレン

5. polythylene vinylene;

三　あらかじめ分離されたネプツニウム二三七であって、重量が一グラムを超えるもの

(iii) neptunium 237 separated beforehand with a weight exceeding 1 gram;

四　削除

(iv) Deleted

五　チャネルの数が一、〇〇〇を超えるデジタル制御方式の無線受信機（民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したものを除く。）又はその部分品若しくは附属品であって、次のイからハまでの全てに該当するもの

(v) digitally controlled radio receivers whose number of channels exceeds 1,000 (excluding those designed for the use in cellular radio communication for

civilian use), or their components or accessories, which fall under all of the following sub-items (a) through (c):

イ　電磁波スペクトラムを自動的に走査することができるもの

(a) those capable of automatically scanning the electromagnetic spectrum;

ロ　受信信号又は送信波の種類を特定することができるもの

(b) those capable of specifying the type of received signals and transmitted waves; and

ハ　チャネル切換え所要時間が一ミリ秒未満のもの

(c) those for which the time required for channel switching is less than 1 millisecond;

五の二　簡易爆発装置を妨害する装置又はその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの

(v)-2 devices preventing detonation of improvised explosive devices or their auxiliary equipment, which fall under either of the following sub-items:

イ　簡易爆発装置を事前に爆発させ、又はその爆発を防止するように設計した無線送信装置（第八条第五号の三に該当するものを除く。）

(a) radio transmitting device designed to explode improvised explosive devices before they reach their target, or to prevent their explosion (excluding those that fall under Article 8, item (v)-3); or

ロ　イに掲げる装置と共に使用され、当該装置と同じ周波数の無線回線の維持が可能となるように設計した技術を用いた装置

(b) devices that is used together with devices stated in sub-item (a) and that uses technology designed to be able to maintain radio lines with the same frequency as that of the device;

六　音波（超音波を含む。）を利用した水中探知装置又はその部分品のうち、次のいずれかに該当するもの

(vi) among underwater detection equipment that uses sound waves (including ultrasonic waves) or their components, those that fall under any of the following sub-items:

イ　ハイドロホンであって、次のいずれかに該当するもの

(a) hydrophones that fall under any of the following clauses:

（一）　可撓性を有するセンサーを組み込んだもの

1. those that incorporate flexible sensors;

（二）　可撓性を有し、直径又は長さが二〇ミリメートル未満であるセンサーを二〇ミリメートル未満の間隔で結合したものを組み込んだもの

2. those that incorporate flexible sensors with a diameter or length of less than 20 millimeters conjoined at intervals of less than 20 millimeters;

（三）　次のいずれかの検出素子を有するもの

3. those that have any of the following detection elements:

1　光ファイバー

i. optical fibers;

２　圧電高分子膜（ふっ化ビニリデン樹脂又はその共重合体を除く。）
ii. piezoelectric polymer membranes (excluding vinylidene fluoride resin and their copolymers);
３　可撓性を有する圧電複合材料
iii. flexible piezoelectric composite materials;
４　ニオブ酸鉛マグネシウム・チタン酸鉛の圧電性単結晶（固溶体から成長したもの）
iv. piezoelectric single crystals of lead magnesium niobate-lead titanate (those that have grown from solid solution);
５　ニオブ酸鉛インジウム・ニオブ酸鉛マグネシウム・チタン酸鉛の圧電性単結晶（固溶体から成長したもの）
v. piezoelectric single crystals of lead indium niobate-lead magnesium niobate-lead titanate (those that have grown from solid solutions);
（四）　加速度による影響を補正する機能を有するものであって、三五メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの
4. those that have the function of correcting the effect of acceleration and are designed to be used at water depths exceeding 35 meters; or
（五）　一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したものであって、四キロヘルツ以下における音圧感度がマイナス二三〇デシベルを超えるように設計したもの
5. those that are designed so that they can be used at water depths exceeding 1,000 meters and so that the sound pressure sensitivity at 4 kilohertz or less will exceed minus 230 decibels;
ロ　えい航ハイドロホンアレーであって、次のいずれかに該当するもの
(b) towed hydrophone arrays that fall under any of the following clauses:
（一）　ハイドロホングループの間隔（隣接する二のハイドロホングループの中心間の距離をいう。以下この号において同じ。）が一二・五メートル未満のもの又は一二・五メートル未満に変更できるもの
1. those for which the hydrophone group interval (meaning the distance between the centers of two adjacent hydrophone groups; the same applies below in this item) is less than 12.5 meters, or those for which the interval can be changed to less than 12.5 meters;
（二）　三五メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの又は改造できるもの
2. those designed so that they can be used at water depths exceeding 35 meters, or those that can be so modified;
（三）　第九条第一号ロ（三）に該当するヘディングセンサーを有するもの
3. those that have a heading sensor falling under Article 9, item (i), sub-item (b), 3.;
（四）　長軸方向に強化したアレーホースを有するもの
4. those that have array hoses reinforced in the long axis direction;

（五）　アレーの直径が四〇ミリメートル未満のもの

5. those with a diameter of less than 40 millimeters;

（六）　削除

6. Deleted

（七）　イ又は第九条第一号ロ（一）に該当するハイドロホンを有するもの

7. those that have a hydrophones falling under sub-item (a) or Article 9, item (i), sub-item (b), 1.; or

（八）　第九条第一号ロ（六）の水中音波センサー

8. underwater sound wave sensors referred to in Article 9, item (i), sub-item (b), 6.;

ハ　えい航ハイドロホンアレー用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関（スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。）を実時間処理できるもの

(c) among signal processors that are designed for towed hydrophone arrays and for which the user can rewrite the program, those that are capable of performing real-time processing or correlation of the time domain or the frequency domain (including spectral analysis, digital filtering, or beam formation);

ニ　海底用又は港湾ケーブル用のハイドロホンアレーであって、次のいずれかに該当するもの

(d) hydrophone arrays for the seabed or harbor cables, which fall under any of the following clauses:

（一）　イ又は第九条第一号ロ（一）に該当するハイドロホンを組み込んだもの

1. those that have hydrophones falling under clause (a) or Article 9, item (i), sub-item (b), 1. incorporated;

（二）　ハイドロホングループの信号を多重化して処理することができるものであって、次の１及び２に該当するもの

2. those capable of processing by multiplexing hydrophone group signals, which fall under the following clauses i. and ii.:

１　三五メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの又は三五メートルを超える水深で使用することができるように調整若しくは取り外しをすることができる水深測定装置を有するもの

i. those designed so that they can be used at water depths exceeding 35 meters, or have a water depth measuring device that can be adjusted or removed so that they can be used at water depths exceeding 35 meters; and

２　えい航ハイドロホンアレーとして転用できるもの

ii. those that can be converted into towed hydrophone arrays;

ホ　海底用又は港湾用ケーブルシステム用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関（スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含

む。）を実時間処理できるもの

(e) among signal processors designed for the seabed or harbor cable systems which the user can rewrite the program, those that are capable of performing real-time processing or correlation of the time domain or the frequency domain (including spectrum analysis, digital filtering, or beam formation);

ヘ　送信機能を有する水中探知装置であって、動作周波数が三〇ヘルツ以上二キロヘルツ以下のもののうち、音圧レベルが二一〇デシベルを超えるもの

(f) among underwater detection equipment that has transmission function with an operating frequency range of 30 hertz or more and 2 kilohertz or less, those with the sound pressure level exceeding 210 decibels;

七　宇宙用に設計した固体の光検出器であって、一、二〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの

(vii) solid optical detectors designed for space use with the maximum sensitivity in the range of more than 1,200 nanometers and 30,000 nanometers or less;

八　パルスレーダー断面積計測装置であって、送信するパルス幅が一〇〇ナノ秒以下のもの又はその部分品

(viii) pulse radar cross-section area measuring devices with pulse width transmitted of 100 nanoseconds or less, or their components;

九　繋索式でない潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの

(ix) untethered submersibles that fall under any of the following sub-items:

イ　有人式の潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの

(a) manned submersibles that fall under any of the following clauses:

（一）　自律的に潜航することができるように設計した潜水艇であって、次の１及び２の揚荷能力を有するもの

1. submersibles designed to be capable of autonomous underwater cruise, which has an unloading capability referred to in the following clasues i. and ii.:

１　当該潜水艇の空中重量の一〇パーセント以上

i. 10% of the weight in air of the submersible or more; and

２　十五キロニュートン以上

ii. 15 kilonewtons or more;

（二）　一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの

2. those designed to be used at water depths exceeding 1,000 meters;

（三）　次の１及び２に該当するもの

3. those that fall under the following clauses i. and ii.:

１　連続して一〇時間以上自律的に潜航することができるように設計したもの

i. those designed so that they can autonomous underwater cruise continuously for 10 hours or more; and

２　潜航可能な距離が五〇海里以上のもの

ii. those that can travel for a distance of 50 nautical miles or more;

ロ　無人式の潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの

(b) unmanned submersibles that fall under any of the following clauses:

（一）　あらゆる地形に対して自動的に針路を決定することができるように設計したもの

1. those that are designed to be capable of automatically determining their course in all types of topography;

（二）　音波によってデータ又は指令を送受することができるもの

2. those that are capable of transmitting and receiving data or commands by sound waves; or

（三）　光伝送の方式によって一、〇〇〇メートル以上の距離でデータ又は指令を送受することができるもの

3. those that are capable of transmitting and receiving data or commands at a distance exceeding 1,000 meters by the optical transmission method;

十　排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置又は磁気軸受であって、伝動装置に使用できるように設計したもの

(x) soundproofing devices or magnetic axis bearings that can be used for vessels whose displacement is 1,000 tons or more, which are designed to be used in transmission gears;

十一　ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品

(xi) ramjet engines, scramjet engines or combined cycle engines, or their components.

（外国為替令別表関係）

(Things Related to the Appended Table of the Foreign Exchange Order)

第十五条　外国為替令（以下「外為令」という。）別表の二の項（一）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

Article 15 (1) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 2 (i) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order (referred to below as "Foreign Exchange Order") is one that falls under any of the following items:

一　第一条第一号から第五号まで、第六号（核燃料物質の成型加工用の装置に限る。）、第七号、第八号イ、第十号イ、第十号の二又は第十号の三のいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術

(i) the technology related to designing, manufacturing, or using the goods that fall under any of Article 1, items (i) through (v), item (vi) (limited to the devices for the mold processing of nuclear fuel materials), item (vii), item (viii), sub-item (a), item (x), sub-item (a), item (x)-2, or item (x)-3;

二　第一条第八号ロ、第十一号、第十七号、第十八号ロからへまで、第十九号、第二

十号、第二十一号イ若しくはロ（一）若しくは（三）、第三十四号若しくは第三十五号のいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術（プログラムを除く。）のうち当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術

(ii) among programs designed to be used for goods that fall under any of Article 1, item (viii), sub-item (b), item (xi), item (xvii), item (xviii), sub-items (b) through (f), item (xix), item (xx), item (xxi), sub-item (a) or (b), 1. or 3. or item (xxxiv) or item (xxxv), or technology (excluding programs) related to designing, manufacturing, or using those programs, the technology necessary to attain or exceed the functions or characteristics of those goods;

三　第一条第十四号に該当する貨物を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術（プログラムを除く。）のうち当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術（数値制御コードを生成するパートプログラム作成用のプログラムであって、種々の部品を加工するために装置を直接使用することができないものを除く。）

(iii) among programs designed for designing, manufacturing, or using the goods that fall under Article 1, item (xiv), or technology (excluding programs) related to designing, manufacturing, or using those programs, the technology necessary to attain or exceed the functions or characteristic of those goods (excluding programs for producing part programs that generate numerical-control codes, which cannot directly use devices for processing various types of components);

四　第一条第八号ロ、第九号、第十号ロ、第十一号、第十四号、第十七号から第二十四号まで、第二十六号から第二十八号まで、第三十号から第五十二号まで、第五十四号から第五十八号まで又は第六十号から第六十二号までのいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術（プログラムを除く。）のうち当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術

(iv) among technology (excluding programs) related to designing, manufacturing, or using the goods that fall under any of Article 1, item (viii), sub-item (b), item (ix), item (x), sub-item (b), item (xi), item (xiv), items (xvii) through (xxiv), items (xxvi) through (xxviii), items (xxx) through (lii), items (liv) through (lviii), or items (lx) through (lxii), the technology necessary to attain or exceed the functions or characteristics of those goods;

五　第一条第六号（リチウムの同位元素の分離用の装置に限る。）、第二十五号、第二十九号、第五十三号又は第五十九号のいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術（プログラムを除く。）

(v) technology (excluding programs) related to designing, manufacturing, or using the goods that fall under any of Article 1, item (vi) (limited to devices for separating lithium isotopes), item (xxv), item (xxix), item (liii), or item (lix);

六　周波数変換器（第一条第八号ロに該当するものを除く。）の性能の特性を拡張し、又は機能を解除することにより、同号ロに該当するように設計したプログラム又は暗号鍵若しくは暗号コード

(vi) programs, or encryption keys or decryption codes, which are designed to fall under Article 1, item (viii), sub-item (b), by expanding the performance characteristics of frequency changers (excluding those that fall under Article 1, item (viii), sub-item (b)), or deactivating their functions;

七　第一条第八号ロに該当する周波数変換器の性能の特性を拡張し、又は解放するために設計したプログラム

(vii) programs designed to expand or release the performance characteristics of frequency changers that fall under Article 1, item (viii), sub-item (b);

八　高速度の撮影が可能なカメラ又はその部分品（第一条第四十四号に該当するものを除く。）の性能の特性を拡張し、又は機能を解除することにより、同号に該当するように設計したプログラム又は暗号鍵若しくは暗号コード

(viii) programs, or encryption keys or decryption codes, which are designed to fall under Article 1, item (xliv), by expanding the performance characteristics of cameras capable of high-speed shooting, or their components (excluding those that fall under Article 1, item (xliv)), or deactivating their functions;

九　高速度の撮影が可能なカメラ又はその部分品（第一条第四十四号に該当するものに限る。）の性能の特性を拡張し、又は解放するために設計したプログラム又は暗号鍵若しくは暗号コード

(ix) programs, or encryption keys or decryption codes, which are designed to expand performance characteristics of cameras capable of high-speed shooting, or their components (limited to those that fall under Article 1, item (xliv)), or deactivating their functions.

2　外為令別表の二の項（二）の経済産業省令で定める技術は、工作機械のための数値制御装置として機能することを可能にするプログラムであって輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術（プログラムを除く。）のうち、輪郭制御をすることができる軸数が五以上の数値制御を可能にするために必要な技術とする。

(2) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 2 (ii) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is, among the technology related to programs that enable a device to function as numerical control equipment for machine tools with five or more axes capable of contour control, or the technology (excluding programs) for designing, manufacturing, or using those programs, the technology necessary for enabling the numerical control of five or more axes capable of contour control.

第十五条の二　外為令別表の三の項（二）の経済産業省令で定める技術は、第二条第二項又は第三項に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、当該貨物の有

する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。

Article 15-2 The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row (3), (ii) of Appended Table of the Foreign Exchange Order is, among the technology related to designing, manufacturing, or using the goods that fall under Article 2, paragraph (2) or (3), the technology necessary to attain or exceed the functions or characteristics of those goods.

第十五条の三　外為令別表の三の二の項（二）の経済産業省令で定める技術は、第二条の二第二項に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。

Article 15-3 The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 3-2 (ii) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is, among the technology related to designing, manufacturing, or using the goods that fall under Article 2-2, paragraph (2), the technology necessary to attain or exceed the functions or characteristics of those goods.

第十六条　外為令別表の四の項（一）の経済産業省令で定める技術は、第三条に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、次のいずれかに該当するものであって、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。

Article 16 (1) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 4 (i) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is, among the technology related to designing, manufacturing, or using the goods that fall under Article 3, the technology that falls under any of the following clauses which is necessary to attain or exceed the functions or characteristics of those goods:

一　五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは第三条第二号ロに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具（型を含む。以下この条において同じ。）若しくは試験装置若しくはこれらの部分品若しくは同号イ（二）若しくは（三）のいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術（プログラムを除く。）

(i) programs designed for using rockets capable of transporting a payload of 500 kilograms or more over a distance of 300 kilometers or more or devices or tools for manufacturing the goods that fall under Article 3, item (ii), sub-item (b) (including molds; the same applies below in this Article) or their testing device or their components, or the goods that fall under either of sub-item (a), 2. or 3. of that item, or technology (excluding programs) related to designing, manufacturing, or using those programs;

一の二　第三条第二号ロ（四）から（六）までのいずれかに該当する貨物を操作、保

守若しくは点検するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術（プログラムを除く。）

(i)-2 programs designed for operating, maintaining or inspecting the goods falling under any of Article 3, item (ii), sub-item (b), 4. through 6., or technology (excluding programs) related to designing, manufacturing, or using those programs;

二　五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットを使用するために設計したプログラムであって、二つ以上の貨物（第三条第二号イ又はロに該当するものに限る。）の機能を調整することができるもの又はその設計、製造若しくは使用に係る技術（プログラムを除く。）

(ii) programs designed for using rockets capable of transporting a payload of 500 kilograms or more over a distance of 300 kilometers or more, which can adjust the functions of two or more goods (limited to those that fall under Article 3, item (ii), sub-item (a), or (b)) or technology (excluding programs) related to designing, manufacturing, or using those goods;

三　第三条第二号イに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術（プログラムを除く。）

(iii) programs designed for designing, manufacturing, or using devices or tools or testing devices for manufacturing the goods that fall under Article 3, item (ii), sub-item (a), or their components, or technology (excluding programs) related to designing, manufacturing, or using those programs;

四　五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくはその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品又は第三条第二号に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術（プログラムを除く。）

(iv) technology (excluding programs) related to designing, manufacturing, or using rockets capable of transporting 500 kilograms or more of payload over a distance of 300 kilometers or more, or devices or tools or testing devices for manufacturing those rockets, or their components, or the goods falling under Article 3, item (ii);

五　第三条第三号イからリまでのいずれかに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品若しくは同号イ、ロ、ト、チ若しくはヌ、第四号から第六号まで、第十七号から第十九号まで、第二十一号イ、第二十二号、第二十二号の二若しくは第二十五号のいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術（プログラムを除く。）

(v) programs designed for using tools or testing devices for manufacturing the goods falling under any of Article 3, item (iii), sub-items (a) through (i) or their components, or goods falling under any of sub-item (a), sub-item (b),

sub-item (g), sub-item (h) or sub-item (j) of that item, or items (iv) through (vi), items (xvii) through (xix), item (xxi), sub-item (a), item (xxii), item (xxii)-2, or item (xxv), or technology (excluding programs) related to designing, manufacturing, or using those programs;

五の二　第三条第十一号に該当する貨物を操作、保守若しくは点検のために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術（プログラムを除く。）

(v)-2 programs designed for operating, maintaining, or inspecting the goods that fall under Article 3, item (xi), or technology (excluding programs) related to designing, manufacturing, or using those programs;

六　ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機（五〇〇キログラム以上のペイロードを運搬することができるものを除く。）又は第三条第三号から第六号まで若しくは第七号から第二十七号までのいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術（プログラムを除く。）

(vi) technology (excluding programs) related to designing, manufacturing, or using rockets or unmanned aircraft that are capable of transporting a payload over a distance of 300 kilometers or more (excluding those capable of transporting a payload of 500 kilograms or more) or the goods falling under any of Article 3, items (iii) through (vi) or items (vii) through (xxvii);

七　第三条第三号ロ、ハ、ホ若しくはヘ若しくは第四号に該当する貨物を設計するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術（プログラムを除く。）

(vii) technology (excluding programs) related to programs designed for designing the goods that fall under Article 3, item (iii), sub-item (b), sub-item (c), sub-item (e) or sub-item (f), or item (iv), or related to designing, manufacturing, or using those programs;

八　第三条第八号から第十号の二までのいずれかに該当する貨物の操作、保守又は点検のために設計したプログラム

(viii) programs designed for operating, maintaining, or inspecting the goods that fall under any of Article 3, items (viii) through (x)-2;

九　第三条第十三号から第十五号まで若しくは第二十六号のいずれかに該当する貨物を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術（プログラムを除く。）

(ix) programs designed for designing, manufacturing, or using goods that fall under any of Article 3, items (xiii) through (xv) or item (xxvi), or technology (excluding programs) related to designing, manufacturing, or using those programs;

十　第三条第十七号イ若しくはヘ若しくは第十七号の二に該当する貨物を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術（プログラムを除く。）

(x) programs designed for designing or manufacturing the goods that fall under

Article 3, item (xvii), sub-item (a) or (f) or item (xvii)-2, or technology (excluding programs) related to designing, manufacturing, or using those programs;

十一　ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット、第三条第二号イに該当する貨物若しくは同号ロに該当する貨物を設計するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術（プログラムを除く。）

(xi) programs designed for designing rockets capable of transporting a payload over a distance of 300 kilometers or more, the goods that fall under Article 3, item (ii), sub-item (a) or the goods that fall under sub-item(b) of that item, or technology (excluding programs) for designing, manufacturing, or using those programs;

十二　ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機を使用するために設計したプログラム（無人航空機を使用するために設計したプログラムにあっては、有人航空機を無人航空機として運用するために設計又は改造したものを含む。）であって、二つ以上の貨物（第三条第二号イ又はロに該当するものに限る。）の機能を調整することができるもの（第二号に該当するものを除く。）

(xii) programs designed for using rockets or unmanned aircraft capable of transporting a payload over a distance of 300 kilometers or more (for programs designed to use unmanned aircraft, including those designed or modified for operating a manned aircraft as an unmanned one), which are capable of adjusting the functions of two or more goods (limited to those falling under Article 3, item (ii), sub-item (a) or (b)) (excluding those falling under item (ii));

２　外為令別表の四の項（二）の経済産業省令で定める技術は、ロケット用のアビオニクス装置又はその部分品の設計に係る技術であって、電磁パルス又は電磁障害の影響を防止するためのもの（プログラムを除く。）とする。

(2) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row (4), (ii) of Appendix Table of the Foreign Exchange Order is the technology related to designing avionics device for rockets or their components, which is for preventing the effects of electromagnetic pulses or electromagnetic interference (excluding programs).

３　外為令別表の四の項（三）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

(3) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row (4), (iii) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following items:

一　ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機の飛行中の空力性能を最適化するために、機体、推進装置及び揚力制御面を統合するための技術（プログラムを除く。）

(i) technology (excluding programs) for integrating the airframe, propulsion device, and lift control surfaces to optimize the aerodynamic performance of an unmanned aircraft capable of transporting a payload over a distance of 300 kilometers or more during the flight;

二　ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットの軌道を最適化するために、飛行制御、誘導又は推進に係るデータを飛行管理装置に統合するための技術（プログラムを除く。）

(ii) technology (excluding programs) for integrating the data related to flight control, guidance or propulsion into the flight control device, to optimize the orbit of a rocket capable of transporting a payload over a distance of 300 kilometers or more;

三　飛行時に記録されたデータを処理して飛行時の全経路にわたる機体の位置決定を可能にするプログラム（ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。）又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術（プログラムを除く。）

(iii) programs that enable the determination of the position of an airframe over its entire route during flight by processing the data recorded during flight (limited to those that can be used for rockets or unmanned aircraft capable of transporting a payload over a distance of 300 kilometers or more) or technology (excluding programs) related to designing, manufacturing, or using those programs.

4　外為令別表の四の項（四）の経済産業省令で定める技術は、オートクレーブの使用に係る技術であって、オートクレーブ内部の環境を規定するためのデータ又は手順（第三条第十六号に該当する貨物を使用するためのものに限る。）とする。

(4) The technology specified by Order of Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 4 (iv) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is technology related to the use of autoclaves, and the data or procedures for specifying the environment inside the autoclaves (limited to those for using the goods that fall under Article 3, item (xvi)).

5　外為令別表の四の項（五）の経済産業省令で定める技術は、原料ガスの熱分解（一、三〇〇度以上二、九〇〇度以下の温度範囲において、かつ、一三〇パスカル以上二〇、〇〇〇パスカル以下の絶対圧力の範囲において行うものに限る。）により生成する物質を基材に定着させるための技術とする。

(5) The technology specified by Order of Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 4 (v) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is technology used to fix substances formed by thermal decomposition of source gas (limited to those performed in the temperature range from 1,300 degrees centigrade or more to 2,900 degrees centigrade or less, and, the range of absolute pressure of 130 pascals or more to 20,000 pascals or less) onto base materials.

第十七条　外為令別表の五の項（一）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

Article 17 (1) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 5 (i) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following items:

一　第四条第四号から第六号までのいずれかに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム

(i) programs designed for designing or manufacturing the things that fall under any of Article 4, items (iv) through (vi);

二　第四条第十二号ハ若しくはニ又は第十五号ハ若しくはニに該当するものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(ii) technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing the things that fall under Article 4, item (xii), sub-item (c) or (d), or item (xv), sub-item (c) or (d);

三　第四条第二号から第十六号までのいずれかに該当するもの（前号に該当するものを除く。）の設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(iii) technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing the things that fall under any of Article 4, items (ii) through (xvi) (excluding those falling under the preceding item).

２　外為令別表の五の項（二）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

(2) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 5 (ii) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following items:

一　第四条第四号から第六号までのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラム

(i) programs designed for using a thing that falls under any of Article 4, items (iv) through (vi);

二　第四条第二号若しくは第十二号ハ若しくはニ又は第十四条第一号に該当するものの使用（修理に係るものに限る。）に係る技術（プログラムを除く。）

(ii) technology (excluding programs) related to the use of a thing that falls under Article 4, item (ii) or item (xii), sub-item (c) or (d) or Article 14, item (i) (limited to those related to repairs).

３　外為令別表の五の項（三）の経済産業省令で定める技術は、セラミック粉末又はセラミック（複合型のものを除く。）であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に係る技術（プログラムを除く。）とする。

(3) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row (5), (iii) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is technology (excluding programs) for designing or manufacturing ceramic powder or ceramics (excluding composites) that fall under any of the following items:

一　セラミック粉末であって、次のイからハまでの全てに該当するもの

(i) ceramic powder that falls under all of the following sub-items (a) through (c):

イ　次のいずれかに該当するものからなるもの

(a) those composed of any of the following substances:

（一）　ジルコニウムの単一又は複合酸化物及びシリコン又はアルミニウムの複合酸化物

1. single or composite oxides of zirconium, and composite oxides of silicon or aluminum;

（二）　ほう素の単一窒化物（立方晶窒化ほう素に限る。）

2. single nitrides of boron (limited to cubic crystalline boron);

（三）　シリコン又はほう素の単一又は複合炭化物

3. single or composite carbides of silicon or boron;

（四）　シリコンの単一又は複合窒化物

4. single or composite nitrides of silicon;

ロ　金属不純物の含有量の全重量に占める割合が、次の数値未満のもの

(b) those in which the ratio of the content of metal impurities to the total weight is less than the following numerical values:

（一）　単一酸化物又は単一炭化物にあっては、〇・一パーセント

1. 0.1% for single oxides or single carbides;

（二）　複合化合物又は単一窒化物にあっては、〇・五パーセント

2. 0.5% for composite compounds or single nitrides;

ハ　次のいずれかに該当するもの

(c) those that fall under any of the following clauses:

（一）　酸化ジルコニウムであって、粒子の径の平均値が一マイクロメートル以下のもののうち、径が五マイクロメートルを超える粒子の重量の合計が全重量の十パーセント以下であるもの

1. among zirconium oxides that have a mean value of the particle diameter of 1 micrometer or less, those in which the total weight of particles with a diameter exceeding 5 micrometers is 10% or less of the total weight;

（二）　粒子の径の平均値が五マイクロメートル以下であって、径が十マイクロメートルを超える粒子の重量の合計が全重量の十パーセント以下であるもの（（一）に該当するものを除く。）

2. those that have a mean value of the particle diameter of 5 micrometers or less, in which the total weight of particles with a diameter exceeding 10 micrometers is 10% or less of the total weight (excluding those that fall under clause 1.);

二　前号の物質からなるセラミック（研磨材を除く。）

(ii) ceramics made of substances referred to in the preceding item (excluding grinding materials).

4　外為令別表の五の項（四）の経済産業省令で定める技術は、ポリベンゾチアゾール

又はポリベンゾオキサゾールの設計又は製造に係る技術（プログラムを除く。）とする。

(4) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 5 (iv) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is technology (excluding programs) for designing or manufacturing polybenzothiazole or polybenzoxazole.

5　外為令別表の五の項（五）の経済産業省令で定める技術は、ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合物の設計又は製造に係る技術（プログラムを除く。）とする。

(5) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry in row 5 (v) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is technology (excluding programs) for designing or manufacturing rubber-like fluorine compounds containing vinyl ether monomers.

6　外為令別表の五の項（七）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

(6) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row (5), (vii) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following items:

一　第四条第十二号ハ若しくはニ若しくは第十五号ハ若しくはニ又は第十四条第一号に該当するものを設計するためのプログラム

(i) programs for designing things falling under Article 4, item (xii), sub-item (c) or (d), item (xv), sub-item (c) or (d), or Article 14, item (i);

二　有機物、金属又は炭素をマトリックスとする複合材料を設計するためのプログラム（前号に該当するものを除く。）

(ii) programs for designing composite materials with a matrix of organic matters, metals, or carbon (excluding those falling under the preceding item).

7　外為令別表の五の項（八）の経済産業省令で定める技術は、第十四条第二号に該当する電波の吸収材又は導電性高分子の使用（据付、保守又は修理に係るものに限る。）に係る技術（プログラムを除く。）とする。

(7) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry as referred to in row (5), (viii) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is technology (excluding programs) related to the use of radio wave absorbers or conductive polymers that fall under Article 14, item (ii) (limited to those related to installations, maintenances, or repairs).

第十八条　外為令別表の六の項（一）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

Article 18 (1) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row (6), (i) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following items:

一　次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除

く。）

(i) technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing things that fall under any of the following sub-items:

イ　第五条第二号イ又は同号ロ（一）若しくは（二）のいずれかに該当するものであって、いずれか一軸以上の直線軸の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇〇九ミリメートル以下のもの

(a) things that fall under any of Article 5, item (ii), or sub-item (a) or sub-item (b), clause 1. or 2. of that item, for which the repeatability of unidirectional positioning of any one or more straight axes is 0.0009 millimeters or less; or

ロ　第五条第二号ロ（三）若しくはニ、第三号又は第五号のいずれかに該当するもの

(b) things that fall under any of Article 5, item (ii), sub-item (b), 3. or sub-item (d), item (iii), or item (v);

二　前号に掲げるもののほか、第五条に該当する貨物の設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(ii) beyond what is stated in the preceding item, technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing the goods that fall under Article 5;

三　次のいずれかに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(iii) programs designed for designing or manufacturing the things falling under any of the following sub-items, or technology (excluding programs) necessary for designing those programs:

イ　第五条第二号イ又は同号ロ（一）若しくは（二）のいずれかに該当するものであって、いずれか一軸以上の直線軸の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇〇九ミリメートル以下のもの

(a) things that fall under any of Article 5, item (ii), sub-item (a), or sub-item (b), clause 1. or 2. of that item, for which the repeatability of unidirectional positioning of any one or more straight axes is 0.0009 millimeters or less; or

ロ　第五条第二号ロ（三）若しくはニ、第三号又は第五号のいずれかに該当するもの

(b) things that fall under any of Article 5, item (ii), sub-item (b), 3. or sub-item (d), item (iii), or item (v);

四　前号に掲げるもののほか、第五条に該当する貨物を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(iv) beyond what is stated in the preceding item, programs designed for designing or manufacturing the goods that fall under Article 5, or the technology (excluding programs) necessary for designing those programs.

２　外為令別表の六の項（二）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

(2) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 6 (ii) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following items:

一　第五条第一号ハ、第二号、第三号又は第五号から第十一号までのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラム

(i) programs designed for the use of the things that fall under any of Article 5, item (i), sub-item (c), item (ii), item (iii), or items (v) through (xi);

二　第五条第四号に該当するものを操作するために設計又は改造したプログラムであって、工作物を任意の形状に加工するために光学設計、工作物の寸法及び材料除去機能を数値制御コマンドに変換するもの

(ii) programs designed or modified to operate the things that fall under Article 5, item (iv), which convert optical designs, size of a workpiece, and material removal functions to numerical control commands in order to process workpieces into arbitrary shapes;

三　前二号に掲げるプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(iii) technology (excluding programs) necessary for designing programs stated in the preceding two items.

３　外為令別表の六の項（三）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

(3) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 6 (iii) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following items:

一　数値制御装置として機能することを可能にするプログラムであって、輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの又はそのプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(i) programs that enable a device to function as numerical control equipment, which have five or more axes capable of controlling contour, or technology (excluding programs) necessary for designing those programs;

二　削除

(ii) Deleted

三　削除

(iii) Deleted

四　意思決定を支援するエキスパートシステムを数値制御装置に組み込むためのプログラムの設計に係る技術（プログラムを除く。）

(iv) technology (excluding programs) related to designing programs for integrating an expert system that supports decision-making into a numerical control equipment; or

五　別表第三の第二欄に掲げるコーティング方法を用いる非電子的基板用コーティング技術であって、同表の第三欄に掲げる基材に対して行う同表の第四欄に掲げるコ

ーティングに係るもの（プログラムを除く。）

(v) non-electronic substrate coating technology using the coating method stated in column 2 of the Appended Table 3, related to the coatings stated in column 4 of that Table applied to base materials stated in column 3 of that Table (excluding programs).

４　外為令別表の六の項（四）の経済産業省令で定める技術は、超塑性成形、拡散接合又は直圧式液圧プレスによる金属の加工用の工具（型を含む。）の設計に係る技術（プログラムを除く。）とする。

(4) The technology specified by Order of Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 6 (iv) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is the technology (excluding programs) related to designing of tools for processing metals (including molds) by super-plastic molding, diffusion bonding, or direct pressure hydraulic pressing.

５　外為令別表の六の項（五）の経済産業省令で定める技術は、航空機材の製造用の液圧式引張成形機（その型を含む。）の設計又は製造に係る技術（プログラムを除く。）とする。

(5) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 6 (v) of the Appended Table is technology (excluding programs) related to designing or manufacturing hydraulic stretch molding machines for manufacturing aircraft materials (including their molds).

第十九条　外為令別表の七の項（一）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

Article 19 (1) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 7 (i) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following items:

一　第六条第二号ハ（一）５若しくは６若しくは（二）３若しくはニ（一）５若しくは６若しくは（二）３若しくは４又は第十六号ロに該当するものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(i) technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing the things that fall under Article 6, item (ii), sub-item (c), clause 1., v. or vi, clause 2., iii., sub-item (d), clause 1., v. or vi., clause 2., iii. or iv., or item (xvi), sub-item (b);

二　第六条に該当するもの（同条第二号ハ（一）５若しくは６若しくは（二）３若しくはニ（一）５若しくは６若しくは（二）３若しくは４又は第十六号ロに該当するものを除く。）の設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）であって、次のいずれにも該当しないもの

(ii) technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing the things that fall under Article 6 (excluding those falling under item (ii), sub-item (c), clause 1., v., or vi., clause 2., iii, sub-item (d), clause 1., v. or vi., clause 2. iii. or iv., or item (xvi), sub-item (b) of that Article), which do not

fall under any of the following sub-items:

イ　同条第十六号の二に該当するものの製造に必要な技術

(a) technology necessary for manufacturing the things that fall under item (xvi)-2 of that Article;

ロ　同条第一号ハからルまでのいずれかに該当する集積回路のうち、次の（一）及び（二）に該当するものの設計又は製造に必要な技術

(b) technology necessary for designing or manufacturing integrated circuits that fall under any of item (i), sub-items (c) through (k) of that Article, which fall under the following clauses 1. and 2.:

（一）　最小線幅が〇・一三〇マイクロメートル以上のもの

1. those whose minimum line width is 0.130 micrometers or more; and

（二）　多層構造を有するもの（金属層が三層以下のものに限る。）

2. those that have a multilayered structure (limited to those in which the number of metal layers is three or less);

ハ　プロセスデザインキット（同条第一号から第八号の四までのいずれかに該当する貨物に係る機能又は技術を実装するライブラリが含まれているものを除く。）

(c) process design kits (excluding those containing a library that implements a function or technology related to the goods falling under any of items (i) through (viii)-4 of that Article);

三　第六条第十六号ロに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム

(iii) programs designed for designing or manufacturing things that fall under Article 6, item (xvi), sub-item (b);

四　第六条第十六号の二に該当するものを設計するために設計したプログラム

(iv) programs designed for designing the things that fall under Article 6, item (xvi)-2;

五　第六条に該当するもの（前二号又は同条第一号若しくは第十八号から第二十二号までのいずれかに該当するものを除く。）を設計し、又は製造するために設計したプログラム

(v) programs designed for designing or manufacturing the things that fall under Article 6 (excluding those that fall under any of the preceding two items or item (i) or items (xviii) through (xxii) of that Article).

2　外為令別表の七の項（二）の経済産業省令で定める技術は、第六条第十七号イ、ロ、ホ、ヘ又はヌのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラムとする。

(2) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 7 (ii) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is programs designed for the use of the things that fall under any of Article 6, item (xvii), sub-item (a), sub-item (b), sub-item (e), sub-item (f), or sub-item (j).

3　外為令別表の七の項（三）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

(3) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 7 (iii) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following items:

一　極端紫外を用いて集積回路を製造するための装置用のマスク又はレチクルのパターンを設計するために特に設計したコンピューテーショナル・リソグラフィ・プログラム

(i) computational lithography programs specially designed for designing patterns for masks or reticles for devices used to manufacture integrated circuits using extreme ultraviolet light;

二　絶縁体が二酸化けい素からなる集積回路の基板であって、シリコンオンインシュレータ構造を有するものの設計又は製造に係る技術（プログラムを除く。）

(ii) technology (excluding programs) related to designing or manufacturing an integrated circuit base board whose insulators are made of silicon dioxide, which has a silicon-on-insulator structure;

三　マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ又はマイクロコントローラのコアであって、論理演算ユニットのアクセス幅のビット数が三二以上のもののうち、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(iii) technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing cores of microprocessors, microcomputers, or microcontrol device with the bit count of the access width of their logic operation unit of 32 or more, which fall under any of the following sub-items:

イ　ベクトル演算器であって、浮動小数点ベクトル演算処理を同時に二を超えて実現できるように設計したもの

(a) vector arithmetic unit that are designed to simultaneously perform more than two vector calculation processing of floating-point numbers;

ロ　六四ビット以上の浮動小数点演算処理を一サイクル当たり四を超えて実現できるように設計したもの

(b) those designed to perform more than four 64bit or more calculation processing of floating-point numbers per cycle;

ハ　一六ビットの固定小数点積和演算処理を一サイクル当たり八を超えて実現できるように設計したもの

(c) those designed to perform more than eight 16bit fixed-point product-sum operation processing of fixed-point numbers per cycle;

四　電磁パルス又は静電放電による中断から一ミリ秒以内に動作の連続性を失うことなくマイクロコンピュータ又はマイクロプロセッサを正常状態に回復するように特に設計したプログラム

(iv) programs specially designed to restore microcomputers or microprocessors to a normal status within 1 millisecond after an interruption due to electromagnetic pulses or electrostatic discharge without losing operational continuity;

五　直径三〇〇ミリメートルのシリコンウエハーの外周の除外領域を二ミリメートル

以下としたウエハーの表面に対するスライス、研削及び研磨の技術のうち、長さ二六ミリメートル、幅八ミリメートルの長方形に分割されたいずれの領域における平坦度が二〇ナノメートル以下を達成するために必要な技術（プログラムを除く。）

(v) among technologies for slicing, grinding, and polishing the surface of a silicon wafer with a diameter of 300 millimeters whose exclusion area of the periphery of the wafer is 2 mm or less, the technology (excluding programs) necessary for achieving the flatness of 20 nanometers or less in any area divided into rectangles with a length of 26 millimeters and a width of 8 millimeters;

六　ゲートオールアラウンド電界効果トランジスタ（ＧＡＡＦＥＴ）の構造を有する集積回路を設計するために特に設計したＥＣＡＤプログラムであって、次のいずれかに該当するもの

(vi) ECAD programs specially designed for designing integrated circuits that have a structure of a gate-all-around field-effect transistor (GAAFET), which fall under any of the following sub-items:

イ　レジスタ転送レベル（ＲＴＬ）をＧＤＳⅡ又はこれと同等のデータベースファイル形式に実装するために特に設計したもの

(a) programs specially designed for implementing the register transfer level (RTL) to GDSII or a database file equivalent to GDSII;

ロ　設計する集積回路内のデータ処理における消費電力又はデータを転送するまでに要する時間を最適化するために特に設計したもの

(b) programs specally designed for optimizing power consumption for data processing in the integrated circuit to be designed, or optimizing the time required for transferring data.

4　外為令別表の七の項（四）の経済産業省令で定める技術は、超電導材料を用いた電子素子の設計又は製造に係る技術（プログラムを除く。）とする。

(4) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row (7), (iv) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is technology (excluding programs) related to designing or manufacturing electronic elements that use superconductive materials.

5　外為令別表の七の項（五）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

(5) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 7 (v) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is to fall under any of the following items:

一　削除

(i) Deleted

二　真空マイクロエレクトロニクス装置の設計又は製造に係る技術（プログラムを除く。）

(ii) technology (excluding programs) related to designing or manufacturing vacuum microelectronics devices;

三　ヘテロ接合の半導体素子（動作周波数が三一・八ギガヘルツ未満の高電子移動度トランジスタ又はヘテロ接合バイポーラトランジスタを除く。）の設計又は製造に係る技術（プログラムを除く。）

(iii) technology (excluding programs) related to designing or manufacturing hetero-junction semiconductor devices (excluding high electron mobility transistors or hetero-junction bipolar transistors whose operating frequency is less than 31.8 gigahertz);

四　電子機器の部分品として用いる基板であって、ダイヤモンド、炭化けい素又は酸化ガリウムを用いたものの設計又は製造に係る技術（プログラムを除く。）

(iv) technology (excluding programs) related to designing or manufacturing substrates used as components of electronic devices that use diamond, silicon carbide, or gallium oxide;

五　動作周波数が三一・八ギガヘルツ以上の真空電子デバイス（クライストロン、進行波管及びこれらから派生したものを含む。）の設計又は製造に係る技術（プログラムを除く。）

(v) technology (excluding programs) related to designing or manufacturing vacuum electronic devices whose operating frequency is 31.8 gigahertz or more (including klystrons and traveling wave tubes, and their derivatives).

第二十条　外為令別表の八の項（一）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの（第一号から第六号までに該当する技術（プログラムを除く。）であって、セキュリティの脆弱性の開示又はサイバー攻撃の対応に係るものを除く。）とする。

Article 20 (1) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 8 (i) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following items (excluding technology falling under items (i) through (vi) (excluding programs) and is related to disclosure of security vulnerability or to response to cyber attacks):

一　第七条第一号ロ又は同条第三号ロに該当するものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(i) technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing the things that fall under Article 7, item (i), sub-item (b) or item (iii), sub-item (b) of that Article;

二　前号に掲げるもののほか、第七条各号に該当する貨物の設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(ii) beyond what is stated in the preceding item, technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing the goods that fall under the items of Article 7;

三　第七条第一号ロ若しくは同条第三号ロに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計若しくは製造に必要な技術

（プログラムを除く。）

(iii) programs designed for designing or manufacturing the things that fall under Article 7, item (i), sub-item (b) or item (iii), sub-item (b) of that Article, or technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing those programs;

四　前号のプログラムの使用に必要な技術（プログラムを除く。）

(iv) technology (excluding programs) necessary for the use of the programs referred to in the preceding item;

五　第三号に掲げるもののほか、第七条各号に該当する貨物を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術（プログラムを除く。）

(v) beyond what is stated in item (iii), programs designed for designing or manufacturing the goods that fall under the items of Article 7, or technology (excluding programs) necessary for designing, manufacturing, or using those programs;

六　第七条に該当するものの使用に必要な技術（プログラムを除く。）

(vi) technology (excluding programs) necessary for the use of the things that fall under Article 7;

２　外為令別表の八の項（二）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの（第三号から第七号までに該当する技術（プログラムを除く。）であって、セキュリティの脆弱性の開示又はサイバー攻撃の対応に係るものを除く。）とする。

(2) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 8 (ii) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following items (excluding technology that falls under items (iii) through (vii) (excluding programs) and is related to disclosure of security vulnerability or to addressing cyber attacks):

一　次のいずれかに該当するデジタル電子計算機の設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(i) technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing digital computers that fall under any of the following sub-items:

イ　加重最高性能が一五実効テラ演算超一六実効テラ演算以下のもの

(a) those whose adjusted peak performance is more than 15 weighted teraFLOPS and 16 weighted teraFLOPS or less; or

ロ　加重最高性能が一六実効テラ演算超七〇実効テラ演算以下のもの

(b) those whose adjusted peak performance is more than 16 weighted teraFLOPS and 70 weighted teraFLOPS or less;

二　デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が一五実効テラ演算超七〇実効テラ演算以下になるものに該当するものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(ii) technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing components that are designed to improve the functions of digital computers,

which falls under technology that achieves an adjusted peak performance of more than 15 weighted teraFLOPS and 70 weighted teraFLOPS or less by aggregating calculation elements;

三　次のいずれかに該当するデジタル電子計算機を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計若しくは製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(iii) programs designed for designing or manufacturing digital computers falling under any of the following sub-items, or technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing those programs:

イ　加重最高性能が一五実効テラ演算超一六実効テラ演算以下のもの

(a) those whose adjusted peak performance is more than 15 weighted teraFLOPS and 16 weighted teraFLOPS or less; or

ロ　加重最高性能が一六実効テラ演算超七〇実効テラ演算以下のもの

(b) those whose adjusted peak performance is more than 16 weighted teraFLOPS and 70 weighted teraFLOPS or less;

四　前号のプログラムの使用に必要な技術（プログラムを除く。）

(iv) technology (excluding programs) necessary for the use of the programs referred to in the preceding item;

五　デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が一五実効テラ演算超七〇実効テラ演算以下になるものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術（プログラムを除く。）

(v) programs designed for designing or manufacturing components that are designed to improve the functions of digital computers, which fall under programs that achieve an adjusted peak performance of more than 15 weighted teraFLOPS and 70 weighted teraFLOPS or less, or technology (excluding programs) necessary for designing, manufacturing, or using those programs;

六　侵入プログラムの作成、指揮統制又は配信を行うように設計若しくは改造されたプログラム（プログラムの更新又は改良を行うために特に設計したものであって、これを受け取るシステムの所有者又は管理者の許可を得た場合にのみ動作するもののうち、更新又は改良されるプログラムを本号に該当するプログラム又は侵入プログラムに変更しないように設計したものを除く。）又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術（プログラムを除く。）

(vi) programs designed or modified to create, command and control, or distribute intrusion software (among those that are specially designed to update or improve programs and operate only when they obtain permission from the owner or administrator of the system that receives the program, excluding those that are designed not to change the program to be updated or improved to the program falling under this item or an intrusion software), or technology (excluding programs) necessary for designing, manufacturing, or

using those programs;

七　侵入プログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(vii) technology (excluding programs) necessary for designing intrusion software;

第二十一条　外為令別表の九の項（一）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

Article 21 (1) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 9 (i) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following items:

一　第八条第二号イ（二）に該当するものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(i) technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing the things that fall under Article 8, item (ii), sub-item (a), 2.;

二　第八条第一号、第二号又は第四号から第五号の五までのいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術（プログラム及び前号に該当するものを除く。）

(ii) technology necessary for designing or manufacturing the things that fall under any of Article 8, item (i), item (ii) or items (iv) through (v)-5 (excluding programs and things that fall under the preceding item);

二の二　第八条第九号から第十二号までのいずれかに該当するもの（同条第十一号ロに該当するものを除く。）の設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(ii)-2 technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing the things that fall under any of Article 8, items (ix) through (xii) (excluding those that fall under item (xi), sub-item (b) of that Article);

三　第八条第九号から第十二号までのいずれかに該当するもの（同条第十一号ロに該当するものを除く。）の使用に必要な技術（プログラムを除く。）

(iii) technology (excluding programs) necessary for the use of the things that fall under any of Article 8, items (ix) through (xii) (excluding those that fall under item (xi), sub-item (b) of that Article);

四　第八条第一号、第二号又は第四号から第五号の五までのいずれかに該当するものの使用（操作に係るものを除く。）に必要な技術（プログラムを除く。）

(iv) technology (excluding programs) necessary for the use (excluding those related to operation) of things that fall under any of Article 8, item (i), item (ii), or items (iv) through (v)-5;

五　第八条第二号イ（二）に該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム

(v) programs designed for designing or manufacturing the things that fall under Article 8, item (ii), sub-item (a), 2.;

六　第八条第一号、第二号又は第四号から第五号の五までのいずれかに該当するものを設計し、又は製造するために設計し、又は改造したプログラム（前号に該当するものを除く。）

(vi) programs designed or modified for designing or manufacturing the things that fall under any of Article 8, item (i), item (ii), or items (iv) through (v)-5 (excluding those that fall under the preceding item);

七　第八条第九号から第十一号イまで又は本項第九号のいずれかに該当するものを設計し、又は製造するために設計し、又は改造したプログラム

(vii) programs designed or modified for designing or manufacturing the things that fall under any of Article 8, items (ix) through (xi), sub-item (a), or item (ix) of this paragraph;

七の二　第八条第十一号ロ又は本項第九号の二に該当するものを設計し、又は製造するために設計し、又は改造したプログラム

(vii)-2 programs designed or modified for designing or manufacturing the things that fall under Article 8, item (xi), sub-item (b), or item (ix)-2 of this paragraph;

八　第八条第一号、第二号又は第四号から第五号の五までのいずれかに該当するものを使用するために設計し、又は改造したプログラム

(viii) programs designed or modified for using the things that fall under any of Article 8, item (i), item (ii), or items (iv) through (v)-5;

八の二　第八条第九号から第十一号イまで又は本項第九号のいずれかに該当するものを使用するために設計し、又は改造したプログラム

(viii)-2 programs designed or modified for using the things that fall under any of Article 8, items (ix) through (xi), sub-item (a), or item (ix) of this paragraph;

八の三　第八条第十一号ロ又は本項第九号の二に該当するものを使用するために設計し、又は改造したプログラム

(viii)-3 programs designed or modified for using the things that fall under Article 8, item (xi), sub-item (b), or item (ix)-2 of this paragraph;

九　プログラムであって、第八条第九号イ若しくはハからホまで、第十号又は第十一号イのいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するもの、当該機能を実現するためのもの又は当該機能のシミュレーションを行うことができるもの（第八条第九号イ又はハからホまでに係るものにあっては、公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたもののうち、その機能が、操作、管理又は保守に関するものに限定されているものを除く。）

(ix) programs that have functions equivalent to those of the goods falling under any of Article 8, item (ix), sub-item (a) or sub-items (c) through (e), item (x) or (xi), sub-item (a), those that are for realizing those functions, or those that are capable of simulating those functions (for those concerning Article 8, item (ix), sub-item (a) or sub-items (c) through (e), excluding, among those using only encryption standards that are opened to the public or for commercial use, those whose functions are limited to those related to operation, management, or maintenance);

九の二　プログラムであって、第八条第十一号ロに該当する貨物の有する機能と同等

の機能を有するもの、当該機能を実現するためのもの又は当該機能のシミュレーションを行うことができるもの（侵入プログラムを除く。）

(ix)-2 programs that have functions equivalent to those of the goods falling under Article 8, item (xi), sub-item (b), that are for realizing the functions, or that are capable of simulating the functions (excluding intrusion software);

十　削除

(x) Deleted

十一　第五号のプログラムの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(xi) technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing the programs referred to in item (v);

十一の二　第五号のプログラムの使用（操作に係るものを除く。）に必要な技術（プログラムを除く。）

(xi)-2 technology (excluding programs) necessary for the use of the programs referred to in item (v) (excluding those related to operation);

十二　第七号、第八号の二又は第九号のプログラムの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(xii) technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing the programs referred to in item (vii), item (viii)-2, or item (ix);

十二の二　第七号、第八号の二又は第九号のプログラムの使用に必要な技術（プログラムを除く。）

(xii)-2 technology (excluding programs) necessary for the use of the programs referred to in item (vii), item (viii)-2, or item (ix);

十三　第六号又は第八号のプログラムの設計、製造又は使用（操作に係るものを除く。）に必要な技術（プログラムを除く。）

(xiii) technology (excluding programs) necessary for designing, manufacturing, or using the programs referred to in item (vi) or (viii) (excluding those related to operation);

十四　削除

(xiv) Deleted

十五　削除

(xv) Deleted

十六　第八条第九号ロに該当する機能を有する技術（プログラムを除く。）であって、暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムの暗号機能を有効化するもの

(xvi) technology (excluding programs) that has the functions falling under Article 8, item (ix), sub-item (b) which activates the encrytion function of certain goods or programs only by using the means of activating the encryption function;

十七　第八条第九号ロに該当する機能を有するプログラムであって、暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムの暗号機能を有効化するもの

(xvii) programs that have the functions falling under Article 8, item (ix), sub-item (b) which activate the encryption function of certain goods or programs only by using the means of activating the encryption function;

２　外為令別表の九の項（二）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

(2) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 9 (ii) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following items:

一　削除

(i) Deleted

二　第八条第一号、第二号、第四号から第七号まで又は第八号の二のいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を提供するために設計したプログラム

(ii) programs designed to provide the functions equivalent to those of goods that fall under any of Article 8, item (i), item (ii), items (iv) through (vii), or item (viii)-2;

三　削除

(iii) Deleted

三の二　伝送通信装置又は電子式交換装置であって、ロ（一）若しくは（五）若しくはニ（一）に該当するものを設計するためのプログラム又は次のいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(iii)-2 programs for designing telecommunication transmission equipment or electronic changers that fall under sub-item (a), 1. or 5., or sub-item (d), 1., or technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing the things falling under any of the following sub-items:

イ　削除

(a) Deleted

ロ　レーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの

(b) those using laser oscillators that fall under any of the following clauses:

（一）　一、七五〇ナノメートルを超える波長のレーザー光を利用するもの

1. those that utilize laser light having a wavelength exceeding 1,750 nanometers;

（二）　削除

2. Deleted

（三）　削除

3. Deleted

（四）　光波長多重化技術を用いたものであって、光搬送波の間隔が一〇〇ギガヘルツ未満のもの

4. those that use light wavelength multiplex technology and for which the interval of optical carrier waves is less than 100 gigahertz;

（五）　アナログ伝送方式を用いたものであって、帯域幅が二・五ギガヘルツを超えるもの（テレビジョン放送（有線テレビジョン放送を含む。）用の装置を除

く。）

5. those that use an analog transmission method whose bandwidth exceeds 2.5 gigahertz (excluding devices for TV broadcasting (including cable TV broadcasting));

ハ　光交換機能を有するものであって、光信号の交換所要時間が一ミリ秒未満もの

(c) those that have an optical switching function for which the switching time of optical signals is less than 1 millisecond;

ニ　無線送信機又は無線受信機であって、次のいずれかに該当するもの

(d) wireless transmitters or wireless receivers that fall under any of the following clauses:

（一）　一、〇二四値を超える直交振幅変調技術を用いたもの

1. those that use quadrature amplitude modulation technology that exceeds the value of 1,024;

（二）　三一・八ギガヘルツを超える周波数で使用することができるもの（国際電気通信連合が無線通信用に割り当てた周波数帯域（無線測位用に割り当てた周波数帯域を除く。）で使用するように設計したものを除く。）

2. those that can be used at a frequency exceeding 31.8 gigahertz (excluding those that are designed to be used at frequency bands allotted for radio communications by the International Telecommunication Union (excluding the frequency bands allotted for radio determination));

（三）　一・五メガヘルツ以上八七・五メガヘルツ以下の周波数範囲で使用することができるものであって、適応型の干渉信号抑圧技術を用いたもののうち、干渉信号を一五デシベルを超えて抑圧することができるように設計したもの

3. among those that can be used within a frequency range of 1.5 megahertz or more and 87.5 megahertz or less and use adaptive interference signal suppression technology, those that are designed to suppress an interfering signal at a level exceeding 15 decibels;

ホ　削除

(e) Deleted

ヘ　専ら移動体において使用するように設計したものであって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(f) those that are designed to be used exclusively in mobile bodies, which fall under the following clauses 1. and 2.:

（一）　光波長が二〇〇ナノメートル以上四〇〇ナノメートル以下で使用することができるもの。

1. those that can be used at a light wavelength of 200 nanometers or more and 400 nanometers or less;

（二）　ローカルエリアネットワークにおいて用いられるもの

2. those used in local area networks;

四　削除

(iv) Deleted

五　人工衛星に搭載することができるように設計した伝送通信装置の設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(v) technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing telecommunication transmission equipment designed to be mounted on artificial satellites;

六　レーザーを用いた通信技術であって、信号を自動的に受信及び追跡し、かつ、大気圏外又は水中との通信を行うことができるものの設計又は使用に係る技術（プログラムを除く。）

(vi) technology (excluding programs) related to designing or using communication technology using lasers that automatically receives or tracks signals, and, is capable of communicating outside the atmosphere or under water;

七　削除

(vii) Deleted

八　削除

(viii) Deleted

九　削除

(ix) Deleted

十　削除

(x) Deleted

十一　プログラムの交換により、マルチバンド、マルチチャンネル、マルチモード、マルチコーディングアルゴリズム又はマルチプロトコルの動作が可能となるように、その信号受信機能が変更可能なデジタル方式のセルラー無線通信に用いる無線基地局受信装置の設計に係る技術（プログラムを除く。）

(xi) technology (excluding programs) related to designing a radio base station receiver used for digital cellular radio communication whose signal reception function can be modified so as to enable multiband, multiple channel, multimode, multi-coding algorithm, or multiprotocol operation by switching programs;

十二　削除

(xii) Deleted

十三　削除

(xiii) Deleted

十四　伝送通信装置の設計に係る技術（プログラムを除く。）であって、スペクトル拡散（周波数ホッピングを含む。）の設計に係るもの

(xiv) the technology (excluding programs) related to designing telecommunication transmission equipment which are related to designing spread spectrum (including frequency hopping);

十五　法執行による監視又は分析を行うために特別に設計又は改造したプログラムであって、次のイ及びロの機能を実現するもの（第一項第五号、同項第六号、同項第八号若しくは本項第二号又は本号ハからトのいずれかに該当するもののために専用

に設計又は改造したプログラムを除く。）

(xi) programs specially designed or modified to perform surveillance or analysis by law enforcement which realizes the functions referred to in the following sub-items (a) and (b) (excluding programs exclusively designed or modified for things that fall under any of paragraph (1), item (v), item (vi), or item (viii), or item (ii) of this paragraph, or sub-items (c) through (g) of this item);

イ　通信サービスプロバイダから、ハンドオーバーインターフェースを用いて取得した通信内容又はメタデータに対して、ハードセレクターに基づいて検索を実行するもの

(a) programs that perform retrievals based on hard selector for content of communications or metadata obtained from a communications service provider by using a handover interface;

ロ　通信内容若しくはメタデータ又はイの検索に基づき、関係する人的ネットワークの解析又は狙った個人の動きを追跡するもの

(b) programs that analyze related human networks or track the movement of targeted individuals, based on the content of communications, metadata, or retrievals referred to in sub-item (a);

ハ　課金目的

(c) purpose of charging fees;

ニ　ネットワークのサービス品質管理（ＱｏＳ）

(d) control of quality of services (QoS) of networks;

ホ　利用者の体感品質管理（ＱｏＥ）

(e) control of quality of experience (QoE);

ヘ　仲介装置

(f) mediation devices; or

ト　モバイル決済又は銀行業務

(g) mobile payment or banking business;

十六　第十五号のプログラムの設計、製造又は使用（操作に係るものを除く。）に必要な技術（プログラムを除く。）

(xvi) technology (excluding programs) necessary for designimg, manufacturing, or using the programs referred to in item (xv) (excluding those related to operation).

3　外為令別表の九の項（三）の経済産業省令で定める技術は、通信用に設計したモノリシックマイクロ波集積回路増幅器であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）とする。

(3) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 9 (iii) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing monolithic microwave integrated circuit amplifiers that are designed for communication which fall under any of the following items:

一　動作周波数が二・七ギガヘルツ超六・八ギガヘルツ以下であって、瞬時帯域幅を

中心周波数で除した値が一五パーセントを超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの

(i) among those with an operating frequency of more than 2.7 gigahertz and 6.8 gigahertz or less for which the value obtained by dividing the instantaneous bandwidth by the center frequency exceeds 15%, those that fall under any of the following sub-items:

イ　動作周波数が二・七ギガヘルツ超二・九ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が七五ワット（四八・七五ディービーエム）を超えるもの

(a) those with an operating frequency of more than 2.7 gigahertz and 2.9 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 75 watts (48.75 dBm);

ロ　動作周波数が二・九ギガヘルツ超三・二ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が五五ワット（四七・四ディービーエム）を超えるもの

(b) those with an operating frequency of more than 2.9 gigahertz and 3.2 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 55 watts (47.4 dBm);

ハ　動作周波数が三・二ギガヘルツ超三・七ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が四〇ワット（四六ディービーエム）を超えるもの

(c) those with an operating frequency of more than 3.2 gigahertz and 3.7 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 40 watts (46 dBm);

ニ　動作周波数が三・七ギガヘルツ超六・八ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が二〇ワット（四三ディービーエム）を超えるもの

(d) those with an operating frequency of more than 3.7 gigahertz and 6.8 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 20 watts (43 dBm);

二　動作周波数が六・八ギガヘルツ超一六ギガヘルツ以下であって、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの

(ii) among those with an operating frequency of more than 6.8 gigahertz and 16 gigahertz or less for which the value obtained by dividing the instantaneous bandwidth by the center frequency exceeds 10%, those that fall under either of the following sub-items:

イ　動作周波数が六・八ギガヘルツ超八・五ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が一〇ワット（四〇ディービーエム）を超えるもの

(a) those with an operating frequency of more than 6.8 gigahertz and 8.5 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 10 watts (40 dBm); or

ロ　動作周波数が八・五ギガヘルツ超一六ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が五ワット（三七ディービーエム）を超えるもの

(b) those with an operating frequency of more than 8.5 gigahertz and 16

gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 5 watts (37 dBm);

三　動作周波数が一六ギガヘルツ超三一・八ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が三・〇ワット（三四・七七ディービーエム）を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもの

(iii) among those with an operating frequency of more than 16 gigahertz and 31.8 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 3.0 watts (34.77 dBm), those for which the value obtained by dividing the instantaneous bandwidth by the center frequency exceeds 10%;

四　動作周波数が三一・八ギガヘルツ超三七ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が〇・一ナノワット（マイナス七〇ディービーエム）を超えるもの

(iv) those with an operating frequency of more than 31.8 gigahertz and 37 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 0.1 nanowatts (minus 70 dBm);

五　動作周波数が三七ギガヘルツ超四三・五ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が一・〇ワット（三〇ディービーエム）を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもの

(v) among those with an operating frequency of more than 37 gigahertz and 43.5 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 1.0 watt (30 dBm), those for which the value obtained by dividing the instantaneous bandwidth by the center frequency exceeds 10%;

六　動作周波数が四三・五ギガヘルツ超七五ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が三一・六二ミリワット（一五ディービーエム）を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもの

(vi) among those with an operating frequency of more than 43.5 gigahertz and 75 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 31.62 milliwatts (15 dBm), those for which the value obtained by dividing the instantaneous bandwidth by the center frequency exceeds 10%;

七　動作周波数が七五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が一〇ミリワット（一〇ディービーエム）を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が五パーセントを超えるもの

(vii) among those with an operating frequency of more than 75 gigahertz and 90 gigahertz or less with a peak saturation output value exceeding 10 milliwatts (10 dBm), those for which the value obtained by dividing the instantaneous bandwidth by the center frequency exceeds 5%;

八　動作周波数が九〇ギガヘルツを超えるものであって、ピーク飽和出力値が〇・一ナノワット（マイナス七〇ディービーエム）を超えるもの

(viii) those with an operating frequency of more than 90 gigahertz with a peak saturation output value exceeding 0.1 nanowatts (minus 70 dBm).

4　外為令別表の九の項（四）の経済産業省令で定める技術は、超電導材料を用いた通信装置であって、使用する超電導材料の臨界温度より低い温度で使用することができ

るように設計し、かつ、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）とする。

(4) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 9 (iv) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is the technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing telecommunications equipment using superconductive materials which is designed so that they can be used at a temperature lower than the critical temperature of the superconductive material used, and, which falls under either of the following items:

一　超電導ゲートを有するデジタル回路用の電流スイッチングの機能を有するものであって、ゲート当たりの遅延時間にゲート当たりの電力消費を乗じて得た値が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇分の一ミリジュール未満のもの

(i) those that have a current switching function for digital circuits that have superconductive gates, for which the value obtained by multiplying the delay time per gate by the power consumption per gate is less than 100,000,000,000 millijoules;

二　周波数を分離する機能を有するものであって、キュー値が一〇、〇〇〇を超える共振回路を有するもの

(ii) those that have a frequency separation function and have resonant circuits with Q-values exceeding 10,000.

第二十二条　外為令別表の一〇の項（一）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

Article 22 (1) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 10 (i) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following items:

一　第九条に該当するものの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(i) the technology (excluding programs) necessary for designing the things that fall under Article 9;

二　第九条第一号イ（二）、（六）若しくはロ（三）、第三号イ、ロ若しくはホ、第四号、第五号イ、第八号イ（一）１、（二）１若しくは（三）、第九号ハ若しくはニ、第十一号イ、ロ、ヲ若しくはワ、第十一号の二イ又は第十三号ニ、チ若しくはルに該当するものの製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(ii) the technology (excluding programs) necessary for manufacturing the things that fall under Article 9, item (i), sub-item (a), 2. or 6. or sub-item (b), 3., item (iii), sub-item (a), sub-item (b), or sub-item (e), item (iv), item (v), sub-item (a), item (viii), sub-item (a), 1., i. or 2., i. or 3., item (ix), sub-item (c) or (d), item (xi), sub-item (a), sub-item (b), sub-item (l), or sub-item (m), item (xi)-2, sub-item (a), or item (xiii), sub-item (d), sub-item (h), or sub-item (k);

三　第九条に該当するもの（前号に該当するものを除く。）の製造に必要な技術（プ

ログラムを除く。）

(iii) the technology (excluding programs) necessary for manufacturing the things that fall under Article 9 (excluding those that fall under the preceding item);

四　第九条第九号ハ若しくはニ又は第十三号ニ、チ若しくはルに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(iv) programs that are designed for designing or manufacturing the things that fall under Article 9, item (ix), sub-item (c) or (d), or item (xiii), sub-item (d), sub-item (h), or sub-item (k), or technology (excluding programs) necessary for designing those programs;

五　第九条第九号から第十号の二まで又は第十三号に該当するもの（前号に該当するものを除く。）を設計し、又は製造するために設計したプログラム

(v) programs that are designed for designing or manufacturing the things that fall under Article 9, items (ix) through (x)-2, or item (xiii) (excluding those that fall under the preceding item);

六　前号のプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(vi) technology (excluding programs) necessary for designing the programs referred to in the preceding item;

七　第九条第三号ニ（一）２又はホ（二）に該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだカメラのために設計又は改造したプログラムであって、当該カメラのフレーム速度の制限を取り外し、かつ、最大フレーム速度が九ヘルツを超えるように設計又は改造したもの

(vii) programs that are designed or modified for cameras incorporating focal plane arrays falling under Article 9, item (iii), sub-item (d), clause 1. ii., or sub-item (e), 2., and are designed or modified to remove the restriction of the frame rate of the camera, and, to reach the maximum frame rate exceeding 9 hertz.

２　外為令別表の一〇の項（二）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

(2) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 10 (ii) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following clauses:

一　第九条第四号若しくは第十三号又は第十四条第八号に該当するものを使用するために設計したプログラム

(i) programs that are designed for using the things that fall under Article 9, item (iv) or Article 13, or Article 14, item (viii);

二　前号のプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(ii) technology (excluding programs) necessary for designing the programs referred to in the preceding item;

三　プログラムであって、次のいずれかに該当するもの

(iii) programs that fall under any of the following sub-items:

イ　磁力計、水中電場センサー又は磁場勾配計の校正装置であって、車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に搭載するように設計したもののために設計したプログラム

(a) programs that are designed for calibrating equipment of magnetometers, underwater electric field sensors, or magnetic field gradiometers, which are designed to be mounted on vehicles, vessels, aircraft, or artificial satellites, or other flying objects for space development;

ロ　車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体上で磁気又は水中電場の異常を検出するために設計したプログラム

(b) programs that are designed to detect abnormalities in the magnetic or underwater electric field on vehicles, vessels, aircraft, or artificial satellites, or other flying objects for space development;

ハ　重力計又は重力勾配計に対する運動の影響を補正するために設計したプログラム

(c) programs that are designed to correct the effect of motion on gravimeters or gravity gradiometers;

ニ　航空管制のために用いられるプログラムであって、五以上の一次レーダーから目標データを受信することができるもの

(d) programs that are used for air traffic control which are capable of receiving target data from five or more primary radars; or

ホ　第九条第十一号の二に該当するものを用いることによって、磁場若しくは電場に係るデータを実時間処理するために設計したプログラム又はソースコード

(e) programs or source codes designed to perform real-time processing of data related to magnetic or electric fields by using the things that fall under Article 9, item (xi)-2;

四　前号のプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(iv) the technology (excluding programs) necessary for designing the programs referred to in the preceding item.

3　外為令別表の一〇の項（三）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

(3) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 10 (iii) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following items:

一　光学的被膜であって、直径又は長軸の長さが五〇〇ミリメートル以上で、かつ、吸収及び散乱による損失が〇・〇〇五未満のもののうち、光学的被膜の厚さに係る均一度が九九・五パーセント以上のものの製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(i) technology (excluding programs) necessary for manufacturing optical coatings with the diameter or length of the long axis of 500 millimeters or more, and for which the loss due to absorption and scattering is less than

0.005, which have a uniformity of the optical coating thickness of 99.5% or more;

二　シングルポイントダイヤモンド工具を用いた旋削に係る技術（プログラムを除く。）であって、面積が〇・五平方メートルを超える曲面を、面精度の二乗平均平方根が一〇ナノメートル未満となるように仕上げるためのもの

(ii) technology (excluding programs) related to lathe turning using single point diamond tools, which are for finishing the curved area with the area exceeding 0.5 square meters to have the root-mean-square of surface precision of less than 10 nanometers.

三　直径又は長軸の長さが一メートル以上の複数の反射鏡からなる反射鏡システムの角度と位相を維持するために設計したプログラム

(iii) programs that are designed to maintain the angle and phase of a reflecting mirror system consisting of multiple reflecting mirrors with the diameter or the length of the long axis of 1 meter or more;

4　外為令別表の一〇の項（四）の経済産業省令で定める技術は、超高出力レーザー発振器の試験装置の設計、製造又は使用に必要な技術（プログラムを除く。）とする。

(4) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 10 (iv) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is technology (excluding programs) necessary for designing, manufacturing, or using testing device for ultra-high output laser oscillators.

5　外為令別表の一〇の項（六）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

(5) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 10 (vi) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following items:

一　次のイ及びロに該当するレードームを製造するためのプログラム

(i) programs for manufacturing radomes that fall under the following sub-items (a) and (b):

イ　電子的に走査が可能なアレーアンテナを保護するために設計したもの

(a) radomes designed to protect array antennas capable of electronical scanning; and

ロ　平均サイドローブに対するメインビームのピーク値の出力比が四〇デシベルを超えるアンテナパターンを生じるもの

(b) radomes that produce antenna patterns with the output ratio of main beam peak value to average side lobes exceeding 40 decibels;

二　前号のプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(ii) technology (excluding programs) necessary for designing the programs referred to in the preceding item.

6　外為令別表の一〇の項（七）の経済産業省令で定める技術は、超高出力レーザー発振器が出力したレーザー光に対する物質の耐久性の試験を行うための装置又はその試験に用いる標的の設計、製造又は使用に必要な技術（プログラムを除く。）とする。

(6) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 10 (vii) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is technology necessary for designing, manufacturing, or using devices for performing a test for durability of substances against laser beams output by extra-high-output laser oscillators or the targets used for the test.

第二十三条　外為令別表の一一の項（一）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

Article 23 (1) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 11 (i) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following items:

一　第十条に該当するものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(i) technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing the things that fall under Article 10;

二　第十条に該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム

(ii) programs designed for designing or manufacturing items that fall under Article 10;

三　前号のプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(iii) technology (excluding programs) necessary for designing the programs referred to in the preceding item.

2　外為令別表の一一の項（二）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

(2) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 11 (ii) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following clauses:

一　姿勢方位基準装置（ジンバル方式のものを除く。）、慣性航法装置その他の慣性装置を使用（操作又は保守（点検）に係るものに限る。）するためのプログラム（ソースコードのものに限る。）又はそのプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(i) programs (limited to those with source codes) for using attitude and heading reference systems (excluding those using the gimbal method), inertial navigation systems and other inertial systems (limited to usage related to operation or maintenance (inspection)), or technology (excluding programs) necessary for designing those programs;

二　第十条の第一号から第四号までのいずれかに該当するものの使用（修理又はオーバーホールに係るものに限る。）に必要な技術（プログラムを除く。）

(ii) technology (excluding programs) necessary for the use of the things that fall under any of Article 10, items (i) through (iv) (limited to those related to repairs or overhauls);

三　第二十七条第三項から第五項までのいずれかに該当するプログラムの設計に係る技術（プログラムを除く。）

(iii) technology (excluding programs) related to designing the programs that fall under any of Article 27, paragraphs (3) through (5);

四　衛星航法システムのレンジングコード（民生用を除く。）を解読するために設計されたプログラム

(iv) programs designed to decode ranging codes (excluding those for civilian use) of satellite navigation systems.

3　外為令別表の一一の項（四）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

(3) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 11 (iv) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following items:

一　次のいずれかに該当するもののためのプログラム（ソースコードのものに限る。）であって、第二号イからニまで又は第三号イからニまで、ト若しくはチのいずれかに該当するものの設計に係る技術（プログラムを除く。）を用いたもの

(i) programs that are for devices that fall under any of the following sub-items (limited to those with source codes) and use technology (excluding programs) related to designing a device falling under any of item (ii), sub-items (a) through (d) or item (iii), sub-items (a) through (d), sub-item (g), or sub-item (h):

イ　飛行の全行程を管理するためのデジタル飛行管理装置

(a) digital air traffic control device for controlling the entire air flight route;

ロ　推進制御と飛行制御を統合するための装置

(b) devices for integrating propulsion control and flight control;

ハ　フライバイワイヤシステム又はフライバイライトシステム

(c) fly-by-wire systems or fly-by-light systems;

ニ　故障許容機能又は自己再構成機能をもつアクティブ飛行制御装置

(d) active flight control device that has a fault tolerance function or a self-reconfiguring function;

ホ　機体表面の静的データを基準とするエアーデータ装置

(e) air data equipment that uses the static data of airframe surface as a standard;

ヘ　三次元ディスプレイ

(f) three-dimensional displays;

二　次のいずれかに該当するものの設計又は製造に係る技術（プログラムを除く。）

(ii) technology (excluding programs) related to designing or manufacturing the devices that fall under any of the following sub-items:

イ　機体表面の静的データを基準とするエアーデータ装置

(a) air data equipment that uses static data of the airframe surface as a standard;

ロ　航空機用の三次元ディスプレイ

(b) three-dimensional display for aircraft;

ハ　飛行制御のために設計した電気アクチュエーター

(c) electric actuators designed for flight control;

ニ　アクティブ飛行制御を行うために設計した飛行制御用光センサーアレー

(d) flight control optical sensor array designed for performing active flight control; or

ホ　データベース参照航法装置であって、水中での航行で使用することができるように設計したもののうち、〇・四海里以下の位置精度を提供するソナー又は重力データベースを利用するもの

(e) among data-based inertial navigation systems that are designed so that they can be used for underwater navigation, those that use a sonar providing a positioning accuracy of 0.4 nautical miles or less or gravity database;

三　アクティブ飛行制御装置の設計に係る技術であって、次のいずれかに該当するもの

(iii) the technology related to designing active flight control device that falls under any of the following sub-items:

イ　航空機の機体若しくは飛行制御系統機器の作動状態の探知、飛行制御データの送信又はアクチュエーターの動作に対する指令のための光通信に係る技術（プログラムを除く。）であって、フライバイライトシステムのアクティブ飛行制御装置の設計に必要なもの

(a) technology related to optical communication for detecting the operating state of aircraft bodies or flight control system machinery and tools, transmission of flight control data, or instructions on operation of actuators (excluding programs), which are necessary for designing active flight control device for fly-by-light systems;

ロ　アクティブ飛行制御装置内の部分品の性能の低下及び故障を予測し、その度合いを緩和するため、部分品のセンサーから得られる情報を分析するための実時間のアルゴリズム

(b) real-time algorithm for analyzing information to be obtained from sensors of components of active flight control device in order to forecast the performance deterioration and failures of those components, and mitigate their degree;

ハ　アクティブ飛行制御装置の性能の低下及び故障の度合いを緩和するため、機器の故障を識別し、力及びモーメントの制御を再構成するための実時間のアルゴリズム

(c) real-time algorithm for identifying failures of machinery and tools and and reconfiguring the control of force and moment in order to mitigate the performance deterioration and failures of active flight control devices;

ニ　飛行の全行程を管理するためデジタル飛行管理装置にデジタル飛行制御、航法及び推進制御のデータを統合する技術（プログラムを除く。）

(d) technology that integrates the data of digital flight control, navigation,

and propulsion control into a digital flight traffic controller in order to control the entire flight route (excluding programs);

ホ　イからニまで、ト又はチのいずれかに該当する技術を用いたアクティブ飛行制御装置のために設計したＣＡＤプログラム

(e) CAD programs designed for an active flight controller that uses technology that falls under any of sub-items (a) through (d), sub-item (g), or sub-item (h);

ヘ　ホのプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(f) technology (excluding programs) necessary for designing the programs referred to in sub-item (e);

ト　フライバイワイヤシステムの機能要件に到達させるために必要な技術（プログラムを除く。）であって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(g) technology (excluding programs) necessary to attain the functional requirements for fly-by-wire systems, which fall under the following 1. and 2.:

（一）　内部ループ機体制御であって、四〇ヘルツ以上の閉ループ制御の周波数を必要とするもの

1. interior loop body control that requires closed loop control frequency of 40 hertz or more;

（二）　次のいずれかに該当するもの

2. those that fall under any of the following clauses:

１　飛行包絡線の範囲内において、〇・五秒以内に補正されなければ復元制御力を失う機体の不安定さを補正できるもの

i. those that are capable of correcting the instabiloity of an airframe that loses the restoring controlling force, if it is not corrected in 0.5 seconds or less within the flight envelope;

２　機体状態の異常変化を補正する際に、二以上の軸の制御を結合するもの

ii. those that combine control of two or more axes in correcting abnormal changes of airframe conditions;

３　ニに規定する機能を実施するもの（オートパイロットを除く。）

iii. those that perform the functions specified in sub-item (d) (excluding the autopilot function); or

４　迎角一八度以上、横滑り角一五度以上、ピッチレート毎秒一五度以上、ヨー・レート毎秒一五度以上又はロールレート毎秒九〇度以上のとき（離着陸時を除く。）に、機体を安定的で制御された飛行とするための技術

iv. technology for making the airframe fly in a stable and controlled manner at an angle of attack of 18 degrees or more, an angle of inclination of 15 degrees or more, a pitch rate of 15 degrees per second or more, a yaw rate of 15 degrees per second or more, or a roll rate of 90 degrees per second or more (excluding during takeoff and landing);

チ　フライバイワイヤシステムの機能要件に到達させるために必要な技術（プログ

ラムを除く。）であって、次の（一）及び（二）を達成するためのもの

(h) technology (excluding programs) necessary for attaining the functional requirements for fly-by-wire systems, which are for attaining the conditions referred to in the following clauses 1. and 2.:

（一）　フライバイワイヤシステム内でいずれか二箇所の故障が連続して起きた場合であっても、機体のコントロールが失われないこと

1. that the control of the airframe will not be lost even if failure consecutively occurs in any two parts in a fly-by-wire system; and

（二）　機体の制御が失われる確率が、飛行時間当たりの故障率の十億分の一以下であること

2. that the probability of losing control of the airframe is one-billionth or less of the failure rate per flight hour;

四　ヘリコプター用の装置であって、次のいずれかに該当するものの設計に係る技術（プログラムを除く。）又はイ若しくはロに該当するもののために設計したＣＡＤプログラム

(iv) technology (excluding programs) related to designing a device for helicopters which falls under any of the following subitems, or a CAD program designed for those that fall under sub-item (a) or (b):

イ　多軸のフライバイワイヤシステム又はフライバイライトシステムであって、次に該当する機能のうち二以上を統合したもの

(a) multiaxial fly-by-wire systems or fly-by-light systems that integrate two or more functions falling under the following clauses:

（一）　コレクティブ制御機能

1. collective control function;

（二）　サイクリック制御機能

2. cyclic control function; and

（三）　ヨー制御機能

3. yaw control function;

ロ　反トルク又は方向を制御する装置であって、循環制御方式によるもの

(b) devices that control counter-torque or direction which are circulation-controlled;

ハ　各翼を個別に制御するための可変形状翼を用いた回転翼

(c) rotary wings that use variable geometry wings for separately controling each wing;

五　前号のプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(v) technology (excluding programs) necessary for designing the programs referred to in the preceding item.

第二十四条　外為令別表の一二の項（一）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

Article 24 (1) The technology specified by Order of the Ministry of Economy,

Trade and Industry referred to in row 12 (i) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following items:

一　第十一条第一号の二、第四号ロ、第六号、第八号又は第十号ヘ若しくはトに該当するものの設計又は製造に必要な技術

(i) technology necessary for designing or manufacturing the things that fall under Article 11, item (i)-2, item (iv), sub-item (b), item (vi), item (viii), or item (x), sub-item (f) or (g);

二　第十一条に該当するもの（前号に該当するものを除く。）の設計又は製造に必要な技術

(ii) technology necessary for designing or manufacturing the things that fall under Article 11 (excluding those falling under the preceding item);

三　エアクッション船、水中翼船又は水線面積を小さくすることによって造波抵抗を減少させるように設計した船舶であって、次のいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(iii) technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing air cushion vessels, hydrofoil crafts, or vessels designed to reduce wave drag by decreasing the water-plane area, which falls under any of the following sub-items:

イ　スカート型のエアクッション船（船体の全周にフレキシブルスカートを取り付けたものに限る。）であって、次の全てに該当するもの

(a) skirt-shaped air cushion vessels (limited to those with a flexible skirt fixed to the whole circumference of the hull) that fall under all of the following clauses:

（一）　有義波高が一・二五メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が三〇ノットを超えるように設計されたもの

1. those that are designed so that the maximum value of speed in a full load condition when the significant wave height is 1.25 meters or more exceeds 30 knots;

（二）　クッションの圧力が三、八三〇パスカルを超えるもの

2. those for which the cushion pressure exceeds 3,830 pascals; and

（三）　満載排水量に対する軽荷排水量の比率が七〇パーセント未満のもの

3. those for which the ratio of the light displacement to full-load displacement is less than 70%;

ロ　側壁型のエアクッション船であって、有義波高が三・二五メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が四〇ノットを超えるもの

(b) sidewall type air cushion vessels for which the maximum value of speed in a full load condition when the significant wave height is 3.25 meters or more exceeds 40 knots;

ハ　水中翼船であって、有義波高が三・二五メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が四〇ノット以上になるように設計したもののうち、船体の揺れ、波の状態その他のデータを測定することによって水中翼を自動的に制御する装置

を有するもの

(c) among hydrofoil crafts that are designed so that the maximum value of speed in a full load condition when the significant wave height is 3.25 meters or more will be 40 knots or more, those which have a device that automatically controls the hydrofoil wing by measuring the shaking of the hull, wave conditions, and other data; or

ニ　水線面積を小さくすることによって造波抵抗を減少させるように設計した船舶であって、次のいずれかに該当するもの

(d) vessels that are designed to reduce wave drag by decreasing the water-plane area, which fall under any of the following clauses:

（一）　満載排水量が五〇〇トンを超えるものであって、有義波高が三・二五メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が三五ノットを超えるように設計したもの

1. those whose full load displacement exceeds 500 tons and are designed so that the maximum value of speed in a full load condition when the significant wave height is 3.25 meters or more will exceed 35 knots;

（二）　満載排水量が一、五〇〇トンを超えるものであって、有義波高が四メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が二五ノットを超えるように設計したもの

2. those whose full load displacement exceeds 1,500 tons and are designed so that the maximum value of speed in a full load condition when the significant wave height is 4 meters or more will exceed 25 knots;

２　外為令別表の一二の項（二）の経済産業省令で定める技術は、第十一条若しくは第十四条第九号若しくは第十号に該当する貨物を使用するために設計したプログラム又は第十一条第一号、第一号の二、第二号、第四号ロ若しくはハ、第八号若しくは第十号若しくは第十四条第九号若しくは第十号に該当する貨物の使用（修理又はオーバーホールに係るものに限る。）に係る技術（プログラムを除く。）とする。

(2) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row (12), (ii) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is technology (excluding programs) related to the use of the programs that are designed for using the goods that fall under Article 11 or Article 14, item (ix) or (x), or the use (limited to that related to repair or overhauls) of the goods that fall under any of Article 11, item (i), item (i)-2, item (ii), item (iv), sub-item (b) or (c), item (viii) or item (x) or Article 14, item (ix) or item (x).

３　外為令別表の十二の項（三）の経済産業省令で定める技術は、水中ノイズを減少させるために設計したプロペラの設計、製造又は使用（修理又はオーバーホールに係るものに限る。）に係る技術とする。

(3) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 12 (iii) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is technology related to designing, manufacturing, or using

(limited to those related to repairs or overhauls) propellers designed for reducing underwater noise.

第二十五条　外為令別表の一三の項（一）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

Article 25 (1) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 13 (i) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following items:

一　第十二条第一号ロ、第四号から第二十号までのいずれかに該当するものの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(i) technology (excluding programs) necessary for designing the things that fall under any of Article 12, item (i), sub-item (b), and items (iv) through (xx);

一の二　第十二条第一号ロ、第四号から第十号まで又は第十一号から第二十号までのいずれかに該当するものの製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(i)-2 technology (excluding programs) necessary for manufacturing the things that fall under any of Article 12, item (i), sub-item (b), items (iv) through (x), or items (xi) through (xx);

二　第十二条第十一号ロに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム

(ii) programs designed for designing or manufacturing the things that fall under Article 12, item (xi), sub-item (b);

三　前号のプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(iii) technology (excluding programs) necessary for designing the programs referred to in the preceding item;

四　第十二条に該当するもの（第二号に該当するものを除く。）を設計し、又は製造するために設計したプログラム

(iv) programs designed for designing or manufacturing the things that fall under Article 12 (excluding those falling under item (ii)); or

五　前号のプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(v) technology (excluding programs) necessary for designing the programs referred to in the preceding item.

2　外為令別表の一三の項（二）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

(2) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 13 (ii) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following items:

一　第三項第三号に該当する技術（プログラムを除く。）を組み込んだプログラムであって、第十二条に該当する貨物のためのフルオーソリティーデジタルエンジン制御システムに使用されるもの

(i) programs in which the technology (excluding programs) falling under paragraph (3), item (iii) is incorporated, which are used for the full authority

digital engine control system for the goods falling under Article 12;

二　前号のプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(ii) technology (excluding programs) necessary for designing the programs referred to in the preceding item;

三　プログラムであって、次のいずれかに該当するもの

(iii) programs that fall under any of the following sub-items:

イ　風洞試験又は飛行試験のデータにより検証された二次元又は三次元の粘性流れのためのプログラムであって、エンジン内の流れをモデリングするためのもの

(a) programs for two-dimensional or three-dimensional viscous flow verified by the data for wind tunnel tests or flight tests, which are for modeling the flow inside an engine;

ロ　航空機用ガスタービンエンジン又はその組立品若しくは部分品の試験のためのプログラムであって、次の（一）及び（二）に該当するもの（試験装置を運用するためのもの、作業者の安全を確保するためのもの又は製造、修理若しくは保守の領収試験（製品が適切に組み立てられ、若しくは修理されたかどうかの判断を行うものをいう。）のためのものを除く。）

(b) programs for testing gas turbine engines for aircraft, or their assemblies or components, which fall under the following 1. and 2. (excluding those for operating testing devices, for securing the safety of workers, or for acceptance test for manufacturing, repairs, or maintenance (meaning tests to judge whether products are appropriately assembled or repaired)):

（一）　次のいずれかに該当するものの試験のために特に設計したもの

1. those specially designed for testing the things that fall under any of the following clauses:

１　航空機用ガスタービンエンジン又はその組立品若しくは部分品であって、次項第二号イからトまで若しくはヌ若しくはヲ、同項第三号若しくは第四号又は第二十七条第六項第一号のいずれかに該当する技術を用いたもの

i. gas turbine engines for aircraft or their assemblies or components, for which the technology falling under any of item (ii), sub-items (a) through (g) or sub-item (j) or sub-item (l) of the following paragraph, item (iii) or item (iv) of that paragraph, or Article 27, paragraph (6), item (i), is used;

２　バイパス流路又はコア流路を提供する多段圧縮機であって、次項第二号イからトまで若しくはヌ若しくはヲ、同項第三号又は第二十七条第六項第一号のいずれかに該当する技術を用いた航空機用ガスタービンエンジンのために特に設計したもの

ii. multistage compressors that provide bypass flow path or core flow path, which are specially designed for gas turbine engines for aircraft that use the technology falling under any of item (ii), sub-items (a) through (g) or sub-item (j) or sub-item (l) of the following paragraph, item (iii) of that paragraph, or Article 27, paragraph (6), item (i);

（二）　次の１及び２を行うように特に設計したもの

2. those specially designed to perform the functions referred to in the following clauses i. and ii.:

１　実時間でのデータの収集及び処理

i. gathering and processing data in real time;

２　試験中における試験物又は試験条件のフィードバック制御

ii. feedback control of test objects or test conditions during tests;

ハ　第十二条第十一号イ又はハに該当する貨物に使用されるプログラムであって、一方向性凝固の材料又は単結晶の材料の成長を制御するために設計したもの

(c) programs used on the goods falling under Article 12, item (xi), sub-item (a) or (c), which are designed to control the growth of unidirectional solidification materials or single crystal materials;

ニ　削除

(d) Deleted

ホ　第十二条第十号の二に該当するものを使用（操作に係るものに限る。）するために設計したプログラム

(e) programs designed for using the things falling under Article 12, item (x)-2 (limited to those related to operation);

ヘ　航空機用ガスタービンエンジンのブレード、ベーン又はチップシュラウドの内部冷却通路を設計するように設計したプログラム

(f) programs designed for designing internal cooling passages of blades, vanes, or tip shrouds of gas turbine engines for aircraft;

ト　次の（一）及び（二）に該当するプログラム

(g) programs falling under the following clauses 1. and 2.:

（一）　航空機用ガスタービンエンジンの空気の熱的状態、空気力学的状態又は燃焼状態を予測するように設計されたもの

1. those designed to predict the thermal state, aerodynamic state, or combustion state of air in gas turbine engines for aircraft;

（二）　実際の航空機用ガスタービンエンジンの性能データに基づき、空気の熱的状態、空気力学的状態又は燃焼状態を理論的にモデル予想するもの

2. those that theoretically predict the thermal state, aerodynamic state, or combustion state of air based on performance data of actual gas turbine engines for aircraft;

四　前号のプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(iv) technology (excluding programs) necessary for designing the programs referred to in the preceding item.

五　第十二条第四号ホ又は同条第四号の三に該当するものを使用（操作に係るものに限る。）するために設計又は改造したプログラム

(v) programs designed or modified for using the things falling under Article 12, item (iv), sub-item (e) or item (iv)-3 of that Article (limited to the use related to operation).

3　外為令別表の一三の項（三）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当

するものとする。

(3) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 13 (iii) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following items:

一　第十二条第一号ロ、第四号から第十号まで又は第十一号から第十九号までのいずれかに該当するガスタービンエンジン又はその部分品の使用（修理又はオーバーホールに係るものに限る。）に係る技術（プログラムを除く。）

(i) technology (excluding programs) related to the use of gas turbine engines, or their components which fall under any of Article 12, item (i), sub-item (b), items (iv) through (x), or items (xi) through (xix) (limited to those related to repairs or overhauls);

二　ガスタービンエンジンの部分品であって、次のいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術（プログラムを除く。）又はその設計のためのプログラム

(ii) technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing components of gas turbine engines that fall under any of the following sub-items, or programs for designing them:

イ　燃焼器であって、次のいずれかに該当するものを有するもの

(a) combustors equipped with the things that fall under any of the following clauses:

（一）　熱遮蔽ライナーであって、燃焼器出口温度が一、六一〇度を超えるもの

1. thermal shield liners for which the temperature of the combustor outlet exceeds 1,610 degrees centigrade;

（二）　非金属ライナー

2. non-metallic liners;

（三）　非金属シェル

3. non-metallic shells;

（四）　ルに該当する冷却孔を有するライナーであって、燃焼器の出口温度が一、六一〇度を超えるもの

4. liners equipped with cooling holes that fall under sub-item (k) for which the temperature of the combustor outlet exceeds 1,610 degrees centigrade;

（五）　プレッシャーゲイン燃焼を利用したもの

5. those that use pressure-gain combustion;

ロ　第四条第十二号に該当する物質、同条第十五号に該当する繊維、同条第七号イに該当するアルミニウムの化合物で補強された金属マトリックス複合材料又は同条第十二号に該当するセラミックマトリックス複合材料を原材料として製造されたもの

(b) those manufactured by using metal matrix composite materials reinforced with a substance that fall under Article 4, item (xii), fiber that fall under item (xv) of that Article, or aluminum compound that fall under item (vii), sub-item (a) of that Article, or ceramic matrix composite materials that fall under item (xii) of that Article as raw materials;

ハ　無冷却式のタービンブレード、ベーン又はチップシュラウドであって、一、一〇〇度以上のガス流路温度で使用するように設計されたもの

(c) non-cooling type turbine blades, vanes, or chip shrouds that are designed to be used at a gas flow path temperature of 1,100 degrees centigrade or more;

ニ　冷却式のブレード、ベーン又はチップシュラウドであって、一、四二〇度以上のガス流路温度で作動するように設計したもの（第二十七条第六項第一号に該当するものを除く。）

(d) cooling type blades, vanes, or tip shrouds that are designed to operate in a gas flow path temperature of 1,420 degrees centigrade or more (excluding those that fall under Article 27, paragraph (6), item (i));

ホ　固相接合法を用いて翼部とディスク部を接合したもの

(e) components that join the wing part and the disk part by using a solid-phase bonding method;

ヘ　削除

(f) Deleted

ト　損傷許容設計された回転部分品であって、粉末冶金材料（第四条第七号ロに該当するものに限る。）を用いたもの

(g) rotation part components with damage tolerance design, which use powder metallurgical materials (limited to those that fall under Article 4, item (vii), sub-item (b));

チ　削除

(h) Deleted

リ　削除

(i) Deleted

ヌ　ファンブレードであって、次の（一）及び（二）に該当するもの

(j) fan blades that fall under the following clauses 1 and 2:

（一）　真空又はガスのみからなる閉鎖キャビティを一以上有し、閉鎖キャビティの体積の合計がファンブレードの総体積の二〇パーセント以上のもの

1. those with one or more closed cavities composed only of vacuum or gas, for which the total volume of the closed cavities is 20% or more of the total volume of the fan blade; and

（二）　体積が五立方センチメートル以上の閉鎖キャビティを一以上有するもの

2. those with one or more closed cavities with a volume of 5 cubic centimeters or more;

ル　本号イ、ニ又は第二十七条第六項第一号に該当するいずれかの技術（プログラムを除く。）を用いたガスタービンエンジンの部分品における冷却孔であって、次のいずれかに該当するものの穴あけ加工に必要な技術

(k) technology necessary for drilling cooling holes of components of gas turbine engines that use any technology (excluding programs) that falls under sub-item (a) or (d) of this item, or Article 27, paragraph (6), item (i),

which fall under any of the following clauses:

（一）　最小断面積が〇・四五平方ミリメートル未満であって、アスペクト比が四・五二を超えるもののうち、穴あけ角度が二五度以下のもの

1. among those with the minimum cross-section area of less than 0.45 square millimeters and with an aspect ratio exceeding 4.52, those for which the drilling angle is 25 degrees or less;

（二）　最小断面積が〇・一二平方ミリメートル未満であって、アスペクト比が五・六五を超えるもののうち、穴あけ角度が二五度を超えるもの

2. among those with the minimum cross-section area of less than 0.12 square millimeters and with an aspect ratio exceeding 5.65, those for which the drilling angle exceeds 25 degrees;

ヲ　ステーター、ベーン、ブレード、チップシール、チップシュラウド、回転ブリング、回転ブリスク又はスプリッターダクトのいずれかであって、次の全てに該当するもの

(l) any of stators, vanes, blades, chip seals, chip shrouds, rotary blings, rotary blisks, or splitter ducts, which fall under all of the following clauses:

（一）　第二十七条第六項第一号ロに該当しないもの

1. those which do not fall under Article 27, paragraph (6), item (i), sub-item (b);

（二）　圧縮機又はファンのために設計されたもの

2. those designed for compressors or fans;

（三）　第四条第十五号ホに該当する物質及び同条第十三号に該当する樹脂を原料として製造されたもの

3. those manufactured by using a substance falling under Article 4, item (xv), sub-item (e) and resin falling under item (xiii) of that Article, as raw materials;

三　ガスタービンエンジンの部分品であって、ガスタービンエンジンをフルオーソリティーデジタルエンジン制御システムの設計若しくは製造に係る技術（プログラムを除く。）であって、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラム

(iii) technology (excluding programs) related to designing or manufacturing components of gas turbine engines, which is a full authority digital engine control system for gas turbine engines, and falls under any of the following technology or programs for designing them:

イ　ガスタービンエンジンの部分品の設計に係る技術であって、エンジンの推力又は軸出力を制御する機能をガスタービンエンジンの部分品に付与するためのもの

(a) technology related to designing components of gas turbine engines, which are for giving the functions that control engine thrust or shaft power to the components of gas turbine engines;

ロ　エンジンの推力や軸出力を調整するために用いられるエンジンの制御及び診断を行う部分品の設計若しくは製造に係る技術

(b) technology related to designing or manufacturing components that control and diagnose engines, which are used for adjusting engine thrust or shaft output;

ハ　エンジンの推力や軸出力を調整するために用いられる制御則アルゴリズム（ソースコードを含む。）の設計に係る技術

(c) technology related to designing control law algorithms (including source codes) which are used for adjusting engine thrust or shaft output;

四　ガスジェネレータータービン、ファンタービン、パワータービン、若しくはプロペリングノズルに係るエンジンの安定性を維持するために設計した流路の形状を可変にするための装置の設計若しくは製造に係る技術（プログラムを除く。）であって、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラム

(iv) technology (excluding programs) related to designing or manufacturing devices for making the flow path shape variable which has been designed to maintain the stability of engines for gas generator turbines, fan turbines, power turbines or propelling nozzles, which fall under any of the following sub-items, or programs for designing it:

イ　エンジンの安定性を維持する部分品の機能を発揮させるための設計に係る技術

(a) technology related to designing that make the components maintaining the stability of engines to fulfill their function;

ロ　流路の形状を可変にするための装置のための部分品であって、エンジンの安定性を維持するものの設計又は製造に係る技術

(b) technology related to designing or manufacturing components of devices for making the flow path shape variable, which maintain the stability of engines;

ハ　流路の形状を可変にするための装置のための制御則アルゴリズム（ソースコードを含む。）であって、エンジンの安定性を維持するものの設計に係る技術

(c) technology related to designing control law algorithms (including source codes) for devices that make the flow path shape variable, which maintain the stability of engines.

4　外為令別表の一三の項（四）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラムとする。

(4) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in in row 13 (iv) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following items, or programs for designing it:

一　風洞用の模型であって、流れの状態に影響を与えない形のセンサーを用いたもののうち、センサーからデータ収集装置にデータを送信できるものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(i) among models for wind tunnels which use sensors with a shape that does not impede flow conditions, technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing those capable of transmitting data from sensors

to data collecting devices;

二　複合材料を用いたプロペラブレード又はプロップファンであって、マッハ数が〇・五五を超える速度において二、〇〇〇キロワットを超える負荷を吸収することができるものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(ii) technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing propeller blades or prop fans that use composite materials, which are capable of absorbing loads that exceed 2,000 kilowatts at a speed exceeding Mach 0.55;

三　ヘリコプター又はチルトローター若しくはチルトウィングを用いた航空機の動力伝達装置の設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(iii) technology (excluding programs) necessary for the designing or manufacturing power transmission devices for helicopters, or aircraft that use tilt rotors or tilt wings;

四　ガスタービンエンジンを装備した固定翼航空機のために設計された翼折りたたみシステムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(iv) technology (excluding programs) necessary for designing a wing folding system designed for a fixed-wing aircraft equipped with a gas turbine engine.

5　外為令別表の一三の項（五）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラムとする。

(5) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 13 (v) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following items or programs for designing it:

一　車両用の往復動ディーゼルエンジンであって、次のイからハまでのすべてに該当するものの設計又は製造に係る技術（プログラムを除く。）

(i) technology (excluding programs) related to designing or manufacturing reciprocating diesel engines for vehicles which fall under all of the following sub-items (a) through (c):

イ　エンジン体積が一・二立方メートル以下のもの

(a) those with an engine volume of 1.2 cubic meters or less;

ロ　グロス軸出力が七五〇キロワットを超えるもの

(b) those with a gross shaft output exceeding 750 kilowatts; and

ハ　キロワットで表したグロス軸出力を立方メートルで表したエンジン体積で除した値が七〇〇を超えるもの

(c) those for which the value obtained by dividing the gross shaft output expressed in kilowatts by the engine volume expressed in cubic meters exceeds 700;

二　高出力ディーゼルエンジン（定格回転数が一分につき二、三〇〇回以上であって、かつ、回転数が一分につき二、三〇〇回の時の正味平均有効圧力が一・八メガパスカル以上のディーゼルエンジンをいう。以下この条において同じ。）の部分品の製造に必要な技術（プログラムを除く。）であって、次のいずれかに該当するもの

(ii) technology (excluding programs) necessary for manufacturing components of high-output diesel engines (meaning diesel engines in which the rated rotation speed is 2,300 or more rotations per minute, and, the brake mean effective pressure is 1.8 megapascals or more when the number of rotations is 2,300; the same applies below in this Article), which falls under any of the following sub-items:

イ　次の（一）から（三）までのすべての部分品が第四条第十二号に該当するセラミックで作られたエンジン（これらの部分品以外のすべての部分品が当該セラミック以外のもので作られているものを除く。）の製造に必要な技術

(a) technology necessary for manufacturing engines for which all components referred to in the following clauses 1. through 3. are made of ceramics that fall under Article 4, item (xii) (excluding engines for which all of the components other than those components are made of materials other than the ceramics):

（一）　シリンダーライナ

1. cylinder liners;

（二）　ピストン

2. pistons;

（三）　シリンダーヘッド

3. cylinder heads;

ロ　ターボ過給機であって、その圧縮機が次の（一）から（三）までのすべてに該当するものの製造に必要な技術

(b) technology necessary for manufacturing turbochargers, whose compressor falls under all of the following clauses 1. through 3.:

（一）　一段当たりの圧力比が四以上のもの

1. those for which the pressure ratio per stage is 4 or more;

（二）　流量が一分につき三〇キログラム以上一三〇キログラム以下のもの

2. those for which the flow rate per minute is 30 kilograms or more and 130 kilograms or less; and

（三）　圧縮機又はそのタービン部分の流路面積を変えることができるもの

3. those for which the flow passage area of the compressors or their turbine parts can be changed;

ハ　燃料噴射装置であって、三七・八度における動粘度が〇・五センチストークス以上二・五センチストークス以下のいずれの燃料にも用いることができるように設計したもののうち、次の（一）及び（二）に該当するものの製造に必要な技術

(c) technology necessary for manufacturing among fuel injection devices designed so that they can be used for any of the fuels with the dynamic viscosity at 37.8 degrees centigrade of 0.5 centistokes or more and 2.5 centistokes or less, those that fall under the following clauses 1. and 2.:

（一）　噴射量が一気筒一噴射当たり二三〇立方ミリメートルを超えるもの

1. one in which the injection quantity exceeds 230 cubic millimeters per

cylinder per injection;

（二）　燃料の特性に応じて同じトルク特性を得るように調速機の特性を自動的に切り替えることができるように電子制御するもの

2. one that electronically controls the devices so that it is possible to automatically switch the characteristics of a governor in order to obtain the same torque characteristics in response to fuel characteristics;

三　ピストンのトップリングの上死点位置において計測したシリンダーの壁面温度が四五〇度を超える高出力ディーゼルエンジンであって、シリンダー壁面に固体、気相又は液体の潤滑剤を用いたものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(iii) technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing high output diesel engines with the wall surface temperature of the cylinder measured at the top dead center of the piston top ring exceeds 450 degrees centigrade, which use solid, gas phase, or liquid lubricants on cylinder wall surfaces.

第二十六条　外為令別表の一四の項の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

Article 26 The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 14 of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following items:

一　第十三条に該当するものの設計、製造又は使用に必要な技術（プログラムを除く。）

(i) technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing the things that fall under Article 13;

二　第十三条に該当するものを設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術（プログラムを除く。）

(ii) programs designed for designing, manufacturing, or using the things that fall under Article 13, or technology (excluding programs) necessary for designing, manufacturing, or using those programs;

三　技術であって、当該技術を用いることによって、ある貨物が第十三条第八項に該当する貨物の有する機能を発揮できるように特に設計したもの

(iii) technology specially designed so as to enable certain goods to perform the functions of the goods falling under Article 13, paragraph (8) by using that technology.

第二十七条　外為令別表の一五の項（一）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

Article 27 (1) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row (15), (i) of the Appended Table of the

Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following items:

一　第十四条第一号から第三号までのいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(i) technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing the things that fall under any of Article 14, items (i) through (iii);

二　第十四条第六号又は第七号に該当するものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(ii) technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing the things that fall under Article 14, item (vi) or (vii);

三　第十四条第五号又は第五号の二に該当するものの設計又は製造に必要な技術

(iii) technology necessary for designing or manufacturing the things that fall under Article 14, item (v) or (v)-2;

四　第十四条第九号又は第十号に該当するものの設計又は製造に必要な技術

(iv) technology necessary for designing or manufacturing the things that fall under Article 14, item (ix) or (x);

五　第三号に該当するプログラムの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(v) technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing programs that fall under item (iii);

六　第十四条第八号又は第十一号に該当するものの設計又は製造に必要な技術

(vi) technology necessary for designing or manufacturing the things that fall under Article 14, item (viii) or (xi); or

七　前号に該当するプログラムの設計に必要な技術（プログラムを除く。）

(vii) technology (excluding programs) necessary for designing the programs that fall under the preceding item.

2　外為令別表の一五の項（三）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術とする。

(2) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row (15), (iii) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is a program that falls under any of the following items or technology necessary for designing those programs:

一　えい航ハイドロホンアレーを用いて受信した音響データの実時間処理のための音響ビーム成形を行うために設計したもの

(i) those designed for performing acoustic beam forming for real time processing of sound data received by using towed hydrophone arrays;

二　えい航ハイドロホンアレーを用いて受信した音響データの実時間処理を行うためのソースコード

(ii) source code for performing real time processing of sound data received by using towed hydrophone arrays;

三　海底用又は港湾用ケーブルシステムを用いて受信した音響データの実時間処理のための音響ビーム成形を行うために設計したもの

(iii) those designed for performing acoustic beam forming for real time processing of sound data received by using the seabed or harbor cable systems;

四　海底用又は港湾用ケーブルシステムを用いて受信した音響データの実時間処理を行うためのソースコード

(iv) source code for performing real time processing of sound data received by using the seabed or harbor cable systems; or

五　次のイ及びロに該当するもの（ソースコードを含む。）

(v) those (including source codes) falling under the following sub-item (a) and (b):

イ　第九条第一号イ（六）に該当するものからの音響データを実時間で処理するもの

(a) those that perform real time processing of sound data obtained from the things falling under Article 9, item (i), sub-item (a), 6.; and

ロ　水中において活動する人の位置を自動的に探知するようにデータを処理するもの

(b) those that process data to automatically detect the position of a person engaged in underwater activities.

3　外為令別表の一五の項（四）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するプログラムとする。

(3) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 15 (iv) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is a program that falls under any of the following items:

一　慣性航法装置その他の慣性装置に用いることによって、これらの装置を第十条第三号に該当するようにすることができるように設計したプログラム

(i) programs designed so that by using inertial navigation systems or other inertial systems, those systems will fall under Article 10, item (iii);

二　船首データと次のいずれかに該当する航法データを連続的に統合し、慣性航法装置その他の慣性装置に用いることによって、これらの装置を第十条第三号に該当するようにすることができるプログラム（ソースコードのものに限る。）

(ii) by continuously integrating heading data and navigation data that falls under any of the following sub-items and using inertial navigation systems or other inertial systems, programs (limited to those that are source codes) that is capable of making those systems fall under Article 10, item (iii):

イ　ドップラー効果を利用するレーダーからの速度データ

(a) speed data obtained from radars that utilize Doppler effects;

ロ　ジーピーエス又はグローナスからの航法データ

(b) navigation data obtained from GPS or GLONASS; or

ハ　データベース参照航法装置からのデータ

(c) data obtained from data-based referenced navigation systems.

4　外為令別表の一五の項（五）の経済産業省令で定める技術は、ジャイロ天測航法装

置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置に用いることによって、その装置を第十条第四号に該当するようにすることができるように設計したプログラムとする。

(4) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 15 (v) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is a program designed so that the use of gyro-astro compasses, or celestial bodies or devices that are capable of determining positions or courses by automatically tracking artificial satellites, enables the program to make them fall under Article 10, item (iv).

5　外為令別表の一五の項（五の二）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

(5) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 15 (v)-2 of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following sub-items:

一　水中ソナー航法装置に用いることによって、その装置を第十条第七号に該当するようにすることができるように設計したプログラム

(i) programs designed so that the use of underwater sonar navigation systems enable the systems to fall under Article 10, item (vii);

二　船首データと次のいずれかに該当する航法データを連続的に統合し、水中ソナー航法装置に用いることによって、その装置を第十条第七号に該当するようにすることができるプログラム（ソースコードのものに限る。）

(ii) by continuously integrating heading data and navigation data that falls under any of the following sub-items and using underwater sonar navigation systems, programs (limited to those that are source codes) that enable the systems to fall under Article 10, item (vii):

イ　ドップラー効果を利用するソナーからの速度データ

(a) speed data obtained from sonars that utilize Doppler effects;

ロ　ジーピーエス又はグローナスからの航法データ

(b) navigation data obtained from GPS or GLONASS; or

ハ　データベース参照航法装置からのデータ

(c) data obtained from data-based referenced navigation systems.

6　外為令別表の一五の項（六）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

(6) The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 15 (vi) of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is one that falls under any of the following items:

一　ガスタービンエンジンの部分品であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを除く。）

(i) technology (excluding programs) necessary for designing or manufacturing gas turbine engine components that fall under any of the following sub-items:

イ　一方向性凝固又は単結晶の合金で鋳造されたガスタービンのブレード、ベーン又はチップシュラウドであって、一、〇〇〇度の温度において単結晶に垂直な方向に二〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が四〇〇時間以上のもの

(a) gas turbine blades, vanes, or tip shrouds cast by unidirectional solidification, or by single crystal alloys, whose stress breakage time is 400 hours or more when a load that generates a 200 megapascals stress is applied in the vertical direction to the single crystal at 1,000 degrees centigrade;

ロ　三一五度を超える温度で使用することができるように設計された有機複合材料を原料として製造されるもの

(b) those that are manufactured by using an organic composite designed to be usable at temperatures exceeding 315 degrees centigrade as a raw material;

二　前号に該当する技術の設計に必要なプログラム

(ii) programs necessary for designing technology that falls under the preceding item.

第二十八条　外為令別表の一六の項の経済産業省令で定める技術は、専ら関税定率法（明治四十三年法律第五十四号）別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術とする。

Article 28 The technology specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry referred to in row 16 of the Appended Table of the Foreign Exchange Order is technology related to designing, manufacturing, or using the goods that exclusively fall under Classes 25 through 40, Classes 54 through 59, Class 63, Classes 68 through 93, or Class 95 of the Appended Table of Custom Tariff Act (Act No. 54 of 1910).

附　則

Supplementary Provisions

この省令は、平成三年十一月十四日から施行する。

This Ministerial Order comes into effect on November 14, 1991.

附　則　〔平成四年三月二十七日通商産業省令第十二号〕

Supplementary Provisions [Order of the Ministry of International Trade and Industry No. 12 of March 27, 1992]

この省令は、平成四年四月一日から施行する。

This Ministerial Order comes into effect on April 1, 1992.

附　則　〔平成四年十二月九日通商産業省令第八十五号〕
Supplementary Provisions [Order of the Ministry of International Trade and Industry No. 85 of December 9, 1992]

1　この省令は、平成四年十二月三十一日から施行する。
(1) This Ministerial Order comes into effect on December 31, 1992.
2　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔平成五年六月十八日通商産業省令第三十号〕
Supplementary Provisions [Order of the Ministry of International Trade and Industry No. 30 of June 18, 1993]

この省令は、平成五年七月十六日から施行する。ただし、第三条及び第十六条第二項の改正規定は、平成五年七月一日から施行する。

This Ministerial Order comes into effect on July 16, 1993; provided, however, that the amended provisions Article 3 and Article 16, paragraph (2) come into effect on July 1, 1993.

附　則　〔平成五年十二月一日通商産業省令第八十五号〕
Supplementary Provisions [Order of the Ministry of International Trade and Industry No. 85 of December 1, 1993]

1　この省令中第一条の規定は、公布の日から、第二条の規定は、平成五年十二月二十二日から施行する。
(1) In this Ministerial Order, the provisions of Article 1 come into effect on the date of promulgation, and the provisions of Article 2 come into effect on December 22, 1993.
2　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(2) Prior laws and regualtions continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔平成六年一月二十八日通商産業省令第三号〕
Supplementary Provisions [Order of the Ministry of International Trade and Industry No. 3 of January 28, 1994]

この省令は、公布の日から施行する。

This Ministerial Order comes into effect on the date of promulgation.

附　則　〔平成六年三月十四日通商産業省令第十号〕
Supplementary Provisions [Order of the Ministry of International Trade and Industry No. 10 of March 14, 1994]

１　この省令は、平成六年三月二十八日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第七条の改正規定（同条第三号ニ中「次のいずれかに該当するもの」を「計算要素を集合させることにより、複合理論性能が一秒につき二六〇メガ演算を超えるもの」に改め、（一）及び（二）を削る部分を除く。）及び第八条の改正規定は、公布の日から施行する。

(1) This Ministerial Order comes into effect on March 28, 1994; provided, however, that the amended provisions of Article 2, the amended provisions of Article 7 (the phrase "equipment that corresponds to any of the following" in item (iii), sub-item (ii) of that Article is amended to "those for which the composite theoretical performance exceeds 260 mega calculations per second by aggregating the calculation elements", excluding the parts that delete clauses 1. and 2.) and the amended provisions of Article 8, come into effect on the date of promulgation.

２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔平成六年六月二十四日通商産業省令第四十九号〕
Supplementary Provisions [Order of the Ministry of International Trade and Industry No. 49 of June 24, 1994]

この省令は、平成六年七月六日から施行する。ただし、第七条の改正規定（同条第五号及び第六号を削る部分に限る。）及び第二十条の改正規定（同条第一項第五号から第九号までを削る部分を除く。）は、公布の日から施行する。

(1) (1) This Ministerial Order comes into effect on July 6, 1994; provided, however, that the amended provisions of Article 7 (limited to the parts that delete item (v) and item (vi) of that Article) and the amended provisions of Article 20 (excluding the part that delete paragraph (1), items (v) through (ix) of that Article) come into effect on the date of promulgation.

２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔平成七年二月二十七日通商産業省令第二号〕
Supplementary Provisions [Order of the Ministry of International Trade and Industry No. 2 of February 27, 1995]

1　この省令は、公布の日から施行する。
(1) This Ministerial Order comes into effect on the date of promulgation.
2　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔平成七年五月十日通商産業省令第四十三号〕
Supplementary Provisions [Order of the Ministry of International Trade and Industry No. 43 of May 10, 1995]

1　この省令は、平成七年五月二十二日から施行する。
(1) This Ministerial Order comes into effect on May 22, 1995.
2　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔平成七年八月九日通商産業省令第六十六号〕
Supplementary Provisions [Order of the Ministry of International Trade and Industry No. 66 of August 9, 1995]

1　この省令は、平成七年八月二十三日から施行する。
(1) This Ministerial Order comes into effect on August 23, 1995.
2　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔平成七年十二月二十日通商産業省令第百六号〕
Supplementary Provisions [Order of the Ministry of International Trade and Industry No. 106 of December 20, 1995]

1　この省令は、平成八年一月三日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第二条の二の改正規定（同条第一項第一号及び第二号中「生ワクチンの成分であるもの」を「ワクチン」に改め、同項第三号中「毒素」の下に「（免疫毒素を除く。）」を加える部分に限る。）、第五条の改正規定、第十五条の改正規定及び第十八条の改正規定

は、公布の日から施行する。
(1) This Ministerial Order comes into effect on January 3, 1996; provided, however, that the amended provisions of Article 1, the amended provisions of Article 2-2 (limited to the parts in which the term "Fresh vaccine ingredients" in paragraph (1), item (i) and item (ii) of that Article is amended, and the term "(excluding immune toxin)" is added after the term "toxin" in item (iii) of that paragraph), the amended provisions of Article 5, the amended provisions of Article 15, and the amended provisions of Article 18, come into effect on the date of promulgation.
２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔平成八年三月二十八日通商産業省令第十八号〕
Supplementary Provisions [Order of the Ministry of International Trade and Industry No. 18 of March 28, 1996]

この省令は、平成八年十月一日から施行する。
This Ministerial Order comes into effect on October 1, 1996.

附　則　〔平成八年八月二十八日通商産業省令第六十号〕〔抄〕
Supplementary Provisions [Order of the Ministry of International Trade and Industry No. 60 of August 28, 1996] [Extract]

（施行期日）
(Effective Date)
１　この省令は、平成八年九月十三日から施行する。
(1) This Ministerial Order comes into effect on September 13, 1996.

（罰則に関する経過措置）
(Transitional Measures for Penal Provisions)
２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔平成九年四月三日通商産業省令第六十五号〕
Supplementary Provisions [Order of the Ministry of International Trade and Industry No. 65 of April 3, 1997]

この省令は、平成九年四月二十九日から施行する。
This Ministerial Order comes into effect on April 29, 1997.

附　則　〔平成十年三月十二日通商産業省令第九号〕
Supplementary Provisions [Order of the Ministry of International Trade and Industry No. 9 of March 12, 1998]

この省令は、平成十年四月一日から施行する。
This Ministerial Order comes into effect on April 1, 1998.

附　則　〔平成十年三月二十五日通商産業省令第十三号〕
Supplementary Provisions [Order of the Ministry of International Trade and Industry No. 13 of March 25, 1998]

（施行期日）
(Effective Date)
1　この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(1) This Ministerial Order comes into effect on April 1, 1998.

（罰則に関する経過措置）
(Transitional Measures for Penal Provisions)
2　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔平成十年八月二十六日通商産業省令第七十八号〕
Supplementary Provisions [Order of the Ministry of International Trade and Industry No. 78 of August 26, 1998]

（施行期日）
(Effective Date)
1　この省令は、公布の日から施行する。
(1) This Ministerial Order comes into effect on the date of promulgation.

（罰則に関する経過措置）
(Transitional Measures for Penal Provisions)
2　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔平成十年十一月五日通商産業省令第八十三号〕
Supplementary Provisions [Order of the Ministry of International Trade and Industry No. 83 of November 5, 1998]

この省令は、平成十年十一月十二日から施行する。
This Ministerial Order comes into effect on November 12, 1998.

附　則　〔平成十一年六月十八日通商産業省令第六十四号〕
Supplementary Provisions [Order of the Ministry of International Trade and Industry No. 64 of June 18, 1999]

（施行期日）
(Effective Date)
1　この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) This Ministerial Order comes into effect on the date of promulgation; provided, however, that the provisions stated in each of the following items come into effect on the date specified in each of those items:
一　第一条の改正規定、第四条第九号の改正規定、第五条第七号の改正規定、第六条第十七号イ及びへの改正規定、第九条第十号ロの改正規定、第十四条の二第二号の改正規定、第十九条第三項及び第五項の改正規定、第二十一条第一項第十号の二、第十一号の二、第十三号及び第十五号並びに同条第二項第四号、第四号の二及び第十一号の改正規定、別表第三の改正規定　平成十一年七月二日
(i) the amended provisions of Article 1, the amended provisions of Article 4, item (ix), the amended provisions of Article 5, item (vii), the amended provisions of Article 6, item (xvii), sub-items (a) and (f), the amended provisions of Article 9, item (x), sub-item (b), the amended provisions of Article 14-2, item (ii), the amended provisions of Article 19, paragraphs (3) and (5), the amended provisions of Article 21, paragraph (1), item (x)-2, item (xi)-2, item (xiii), and item (xv) and paragraph (2), item (iv), item (iv)-2, and item (xi) of that Article, and the amended provisions of the Appended Table 3: July 2, 1999;
二　第二条第一項の改正規定及び第十四条の二第五十一号の二から第五十一号の四までの追加規定　平成十一年七月十八日
(ii) the amended provisions of Article 2, paragraph (1) and the additional provisions of Article 14-2, items (li)-2 through (li)-4: July 18, 1999.

（罰則に関する経過措置）
(Transitional Measures for Penal Provisions)
2　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔平成十二年六月二十三日通商産業省令第百十五号〕
Supplementary Provisions [Order of the Ministry of International Trade and Industry No. 115 of June 23, 2000]

1　この省令は、平成十二年七月七日から施行する。ただし、第一条第八号、第九号、第十一号、第十四号、第十八号、第二十一号、第二十二号、第二十四号イ及びハ、第二十七号及び第三十三号の改正規定、同条第三十四号の改正規定（同号イ（一）及びロ（一）中「七五ミリメートル以上の」を「七五ミリメートルを超える」に改める部分に限る。）、同条第三十五号、第三十六号、第三十八号、第四十号、第四十四号並びに第五十七号、第三条第七号ホ、第十六号イ及びト、第二十号並びに第二十二号の改正規定、第六条第一号の改正規定（同号ハ（三）中「並列プロセッサ」を「並列プロセッサ用に設計したもの」に改める部分を除く。）、同条第二号ロ、第四号及び第八号、第七条、第八条、第九条第一号イ、第十二条、第十三条第五項、第十四条第五号並びに第六号イ及びニ、第十四条の二第七十四号、第十九条、第二十条並びに第二十一条の改正規定並びに第二十五条の改正規定（同条第三項第二号中ヌを削り、ルをヌとし、ヲをルとする部分に限る。）は、公布の日から施行する。

(1) This Ministerial Order comes into effect on July 7, 2000; provided, however, that the amended provisions of Article 1, item (viii), item (ix), item (xi), item (xiv), item (xviii), item (xxi), item (xxii), item (xxiv), sub-items (a) and (c), item (xxvii), and item (xxxiii); the amended provisions of item (xxxiv) of that Article (limited to the part in which the phrase "those that are 75 millimeters or more" in sub-item (a), 1. and sub-item (b), 2. of that item is amended to "those that exceed 75 millimeters"); the amended provisions of item (xxxv), item (xxxvi), item (xxxviii), item (xl), item (xliv) and item (lvii) of that Article, Article 3, item (vii), sub-item (e), item (xvi), sub-items (a) and (g), item (xx), and item (xxii); the amended provisions of Article 6, item (i) (excluding the part in which the term "parallel processors" in sub-item (c), 3. of that item is amended to "devices designed for parallel processors"), the amended provisions of item (ii), sub-item (b), item (iv) and item (viii) of that Article, Article 7, Article 8, Article 9, item (i), sub-item (a), Article 12, Article 13, item (v), Article 14, item (v) and item (vi), sub-items (a) and (d), Article 14-2, item (lxxiv), Article 19, Article 20 and Article 21; and the amended provisions of Article 25 (limited to the parts in which paragraph (3), item (ii), sub-item (j) of that Article is deleted, sub-item (k) is changed to sub-item (j), and sub-item (l) is changed to (k)), come into effect on the date of promulgation.

（罰則に関する経過措置）

(Transitional Measures for Penal Provisions)

2　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔平成十二年十月三十一日通商産業省令第二百六十五号〕

Supplementary Provisions [Order of the Ministry of International Trade and Industry No. 265 of October 31, 2000]

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

This Ministerial Order comes into effect on January 6, 2001.

附　則　〔平成十二年十二月二十七日通商産業省令第四百八号〕

Supplementary Provisions [Order of the Ministry of International Trade and Industry No. 408 of December 27, 2000]

（施行期日）

(Effective Date)

1　この省令は、公布の日から施行する。

(1) This Ministerial Order comes into effect on the date of promulgation.

（罰則に関する経過措置）

(Transitional Measures for Penal Provisions)

2　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔平成十三年五月十六日経済産業省令第百六十三号〕

Supplementary Provisions [Order of Ministry of Economy, Trade and Industry No. 163 of May 16, 2001]

（施行期日）

(Effective Date)

1　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第十号ロ、第二条の二、第四条、第五条第二号ロ、第八号及び第十号、第六条第二号、第五号、第十七号及び第十八号の改正規定、第九条第八号の改正規定（同号ロ（六）中「組み込んだもの」を「組み込んだビデオカメラ」に改める部分を除く。）、第十条、第二十一条第二項第三号の二ニ及び別表第三の備考の第十六号の改正規定は、平成十三年五月三十日から施行する。

(1) This Ministerial Order comes into effect on the date or promulgation; provided, however, that the amended provisions of Article 1, item (x), sub-item (b), Article 2-2, Article 4, Article 5, item (ii), sub-item (b), item (viii), and item (x), Article 6, item (ii), item (v), item (xvii) and item (xviii); the amended provisions of Article 9, item (viii) (excluding the part in which the term "incorporated" in (b), 6. of that item is amended to "video cameras incorporated"); the amended provisions of Article 10, Article 21, paragraph (2), item (iii)-2, sub-item (d) and item (xvi) of the Remarks of the Appended Table 3, come into effect on May 30, 2001.

（罰則に関する経過措置）
(Transitional Measures for Penal Provisions)
２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔平成十三年十二月二十八日経済産業省令第二百四十七号〕
Supplementary Provisions [Order of Ministry of Economy, Trade and Industry No. 247 of December 28, 2001]

（施行期日）
(Effective Date)
１　この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(1) This Ministerial Order comes into effect on April 1, 2002.

（罰則に関する経過措置）
(Transitional Measures for Penal Provisions)
２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔平成十四年六月十四日経済産業省令第八十五号〕
Supplementary Provisions [Order of Ministry of Economy, Trade and Industry No. 85 of June 14, 2002]

（施行期日）
(Effective Date)
１　この省令は平成十四年七月十五日から施行する。
(1) This Ministerial Order comes into effect on July 15, 2002.

（罰則に関する経過措置）
(Transitional Measures for Penal Provisions)
２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔平成十四年十月二十一日経済産業省令第百八号〕
Supplementary Provisions [Order of Ministry of Economy, Trade and Industry No. 108 of October 21, 2002]

（施行期日）
(Effective Date)
１　この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、平成十五年一月一日から施行する。
(1) This Ministerial Order comes into effect on November 1, 2002; provided, however, that the amended provisions of Article 2 come into effect on January 1, 2003.

（罰則に関する経過措置）
(Transitional Measures for Penal Provisions)
２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔平成十五年四月一日経済産業省令第五十二号〕
Supplementary Provisions [Order of Ministry of Economy, Trade and Industry No. 52 of April 1, 2003]

この省令は、公布の日から施行する。
This Ministerial Order comes into effect on the date of promulgation.

附　則　〔平成十五年十二月二十四日経済産業省令第百五十九号〕
Supplementary Provisions [Order of Ministry of Economy, Trade and Industry No. 159 of December 24, 2003]

（施行期日）
(Effective Date)
１　この省令は、平成十六年一月二十日から施行する。

(1) This Ministerial Order comes into effect on January 20, 2004.

（罰則に関する経過措置）
(Transitional Measures for Penal Provisions)
２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔平成十六年十一月十日経済産業省令第百四号〕
Supplementary Provisions [Order of Ministry of Economy, Trade and Industry No. 104 of November 10, 2004]

（施行期日）
(Effective Date)
１　この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
(1) This Ministerial Order comes into effect on January 1, 2005.

（罰則に関する経過措置）
(Transitional Measures for Penal Provisions)
２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔平成十七年十二月二日経済産業省令第百十六号〕
Supplementary Provisions [Order of Ministry of Economy, Trade and Industry No. 116 of December 2, 2005]

（施行期日）
(Effective Date)
１　この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
(1) This Ministerial Order comes into effect on January 1, 2006.

（罰則に関する経過措置）
(Transitional Measures for Penal Provisions)
２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(2) Prior laws and regualtions continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔平成十八年十一月十七日経済産業省令第九十七号〕
Supplementary Provisions [Order of Ministry of Economy, Trade and Industry No. 97 of November 17, 2006]

この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
This Ministerial Order comes into effect on January 1, 2007.

附　則　〔平成二十年三月二十六日経済産業省令第二十一号〕
Supplementary Provisions [Order of Ministry of Economy, Trade and Industry No. 21 of March 26, 2008]

（施行期日）
(Effective Date)
1　この省令は、平成二十年五月十五日から施行する。
(1) This Ministerial Order comes into effect on May 15, 2008.

（罰則に関する経過措置）
(Transitional Measures for Penal Provisions)
2　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔平成二十年八月二十七日経済産業省令第五十五号〕
Supplementary Provisions [Order of Ministry of Economy, Trade and Industry No. 55 of August 27, 2008]

この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。
This Ministerial Order comes into effect on November, 1, 2008.

附　則　〔平成二十一年八月二十八日経済産業省令第四十六号〕
Supplementary Provisions [Order of Ministry of Economy, Trade and Industry No. 46 of August 28, 2009]

この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。
This Ministerial Order comes into effect on October 1, 2009.

附　則　〔平成二十二年三月五日経済産業省令第六号〕〔抄〕
Supplementary Provisions [Order of Ministry of Economy, Trade and Industry No. 6 of March 5, 2010] [Extract]

（施行期日）
(Effective date)
第一条　この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
Article 1　This Ministerial Order comes into effect on April 1, 2010.

（経過措置）
(Transitional Measures)
第二条　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
Article 2　Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔平成二十三年五月十八日経済産業省令第二十六号〕
Supplementary Provisions [Order of Ministry of Economy, Trade and Industry No. 26 of May 18, 2011]

（施行期日）
(Effective Date)
第一条　この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
Article 1　This Ministerial Order comes into effect on July 1, 2011.

（罰則に関する経過措置）
(Transitional Measures for Penal Provisions)
第二条　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
Article 2　Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔平成二十四年七月十九日経済産業省令第五十六号〕
Supplementary Provisions [Order of Ministry of Economy, Trade and Industry No. 56 of July 19, 2012]

（施行期日）
(Effective Date)
１　この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。
(1) This Ministerial Order comes into effect on August 1, 2012.

（罰則に関する経過措置）
(Transitional Measures for Penal Provisions)

２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔平成二十五年九月二十七日経済産業省令第五十一号〕
Supplementary Provisions [Order of Ministry of Economy, Trade and Industry No. 51 of September 27, 2013]

（施行期日）
(Effective Date)
１　この省令は、平成二十五年十月十五日から施行する。
(1) This Ministerial Order comes into effect on October 15, 2013.

（罰則に関する経過措置）
(Transitional Measures for Penal Provisions)
２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔平成二十六年八月十四日経済産業省令第四十一号〕
Supplementary Provisions [Order of Ministry of Economy, Trade and Industry No. 41 of August 14, 2014]

（施行期日）
(Effective Date)
１　この省令は、平成二十六年九月十五日から施行する。
(1) This Ministerial Order comes into effect on September 15, 2014.

（罰則に関する経過措置）
(Transitional Measures for Penal Provisions)
２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔平成二十七年八月十一日経済産業省令第六十号〕
Supplementary Provisions [Order of Ministry of Economy, Trade and Industry No. 60 of August 11, 2015]

（施行期日）

(Effective Date)

1　この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(1) This Ministerial Order comes into effect on October 1, 2015.

（罰則に関する経過措置）

(Transitional Measures for Penal Provisions)

2　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔平成二十八年十一月十八日経済産業省令第百七号〕

Supplementary Provisions [Order of Ministry of Economy, Trade and Industry No. 107 of November 18, 2016]

（施行期日）

(Effective Date)

1　この省令は、平成二十九年一月七日から施行する。ただし、第一条中輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第五条第二号及び第十八条の改正規定は、平成二十九年六月一日から施行する。

(1) This Ministerial Order comes into effect on January 7, 2017; provided, however, that the amending provisions of Article 5, item (ii) and Article 18 of the Ministerial Order Specifying Goods and Technologies Pursuant to Provisions of the Appended Table 1 of the Export Trade Control Order and the Appended Table of the Foreign Exchange Order in Article 1 come into effect on June 1, 2017.

（罰則に関する経過措置）

(Transitional Measures for Penal Provisions)

2　この省令（前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order (for the amended provisions prescribed in the proviso to the preceding paragraph, those amended provisions).

附　則　〔平成二十九年十二月六日経済産業省令第八十七号〕

Supplementary Provisions [Order of Ministry of Economy, Trade and Industry No. 87 of December 6, 2017]

（施行期日）
(Effective Date)
１　この省令は、平成三十年一月二十二日から施行する。
(1) This Ministerial Order comes into effect on January 22, 2018.

（罰則に関する経過措置）
(Transitional Measures for Penal Provisions)
２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔平成三十年十一月十六日経済産業省令第六十三号〕
Supplementary Provisions [Order of Ministry of Economy, Trade and Industry No. 63 of November 16, 2018]

（施行期日）
(Effective Date)
１　この省令は、平成三十一年一月九日から施行する。
(1) This Ministerial Order comes into effect on January 9, 2019.

（罰則に関する経過措置）
(Transitional Measures for Penal Provisions)
２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔令和元年七月一日経済産業省令第十七号〕
Supplementary Provisions [Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry No. 17 of July 1, 2019]

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。
This Ministerial Order comes into effect on the date on which the Act Partially Amending the Unfair Competition Prevention Act comes into effect (July 1, 2019).

附　則　〔令和元年十一月二十八日経済産業省令第四十四号〕
Supplementary Provisions [Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry No. 44 of November 28, 2019]

（施行期日）
(Effective Date)
１　この省令は、令和二年一月二十二日から施行する。
(1) This Ministerial Order comes into effect on January 22, 2020.

（罰則に関する経過措置）
(Transitional Measures for Penal Provisions)
２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔令和二年一月十四日経済産業省令第二号〕
Supplementary Provisions [Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry No. 2 of January 14, 2020]

この省令は、令和二年一月二十二日から施行する。
This Ministerial Order comes into effect on January 22, 2020.

附　則　〔令和二年二月五日経済産業省令第七号〕
Supplementary Provisions [Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry No. 7 of February 5, 2020]

この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日（令和二年二月五日）から施行する。
This Ministerial Order comes into effect on the date on which the Act Partially Amending the Act on the Prevention of Infectious Diseases in Livestock comes into effect (February 5, 2020).

附　則　〔令和二年七月一日経済産業省令第六十二号〕
Supplementary Provisions [Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry No. 62 of July 1, 2020]

この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日（令和二年七月一日）から施行する。
This Ministerial Order comes into effect on the date on which the Act Partially Amending the Act on the Prevention of Infectious Diseases in Livestock comes into effect (July 1, 2020).

附　則　〔令和二年十二月十日経済産業省令第八十六号〕
Supplementary Provisions [Order of the Ministry of Economy, Trade and

Industry No. 86 of December 10, 2020]

（施行期日）

(Effective Date)

1　この省令は、令和三年一月二十七日から施行する。

(1) This Ministerial Order comes into effect on January 27, 2021.

（罰則に関する経過措置）

(Transitional Measures for Penal Provisions)

2　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔令和三年十月十五日経済産業省令第七十四号〕

Supplementary Provisions [Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry No. 74 of October 15, 2021]

（施行期日）

(Effective Date)

1　この省令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

(1) This Ministerial Order comes into effect on the day on which two months have passed from the date of promulgation.

（罰則に関する経過措置）

(Transitional Measures for Penal Provisions)

2　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

附　則　〔令和四年十月六日経済産業省令第七十八号〕

Supplementary Provisions [Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry No. 78 of October 16, 2022]

（施行期日）

(Effective Date)

1　この省令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

(1) This Ministerial Order comes into effect on the day on which two months have passed from the date of promulgation.

（罰則に関する経過措置）
(Transitional Measures for Penal Provisions)
２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(2) Prior laws and regulations continue to govern the applicability of penal provisions to acts that a person has committed before the enforcement of this Ministerial Order.

別表第一
Appended Table 1
削除
Deleted

別表第二（第十条、第十二条関係）
Appended Table 2 (Re: Article 10 and Article 12)
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、クロアチア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、インド、アイルランド、イタリア、大韓民国、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、スロベニア、南アフリカ共和国、スペイン、スロバキア、スウェーデン、スイス、トルコ、ウクライナ、英国、アメリカ合衆国
Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, India, Ireland, Italy, Republic of Korea, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, The Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovenia, Republic of South Africa, Spain, Slovakia, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom, and United States of America

別表第三（第五条、第十八条関係）
Appended Table 3 (Re: Article 5 and Article 18)

	コーティング方法 Coating Method	基材 Base Material	コーティング Coating
一 1	原料ガスの化学反応により生成するコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 Method of fixing the coating material generated by chemical reaction of source	超合金 Super alloy	アルミニウム化合物 Aluminum compounds
		セラミック又は低熱膨張ガラス Ceramics or low-thermal expansion glass	けい素化合物、炭化物、誘電体膜、ダイヤモンド又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 Silicon compounds, carbides, dielectric films, diamonds, or amorphous diamond-like carbon films

	gas onto the surface of a base material	炭素及び炭素繊維を用いた複合材料（以下「カーボンカーボン」という。）、セラミック複合材料又は金属基複合材料 Composite materials using carbon and carbon fibers (referred to as "carbon-carbon" below), ceramic composite materials, or metal matrix composites	けい素化合物、炭化物、耐火金属、これらの組合せからなる混合物、誘電体膜、アルミニウム化合物、合金アルミニウム化合物又は窒化ほう素 Silicon compounds, carbides, refractory metals, and mixtures consisting of their combinations, dielectric films, aluminum compounds, aluminum alloy compounds, or boron nitrides
		炭化タングステン合金又は炭化けい素 Tungsten carbide alloys or silicon carbides	炭化物、タングステン、炭化物とタングステンの混合物又は誘電体膜 Carbides, tungsten, mixtures of carbides and tungsten, or dielectric films
		モリブデン又はモリブデン合金 Molybdenum or molybdenum alloys	誘電体膜 Dielectric films
		ベリリウム又はベリリウム合金 Beryllium or beryllium alloys	誘電体膜、ダイヤモンド又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 Dielectric films, diamonds, or amorphous diamond-like carbon films
		センサー窓材 Sensor window materials	誘電体膜、ダイヤモンド又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 Dielectric films, diamonds, or amorphous diamond-like carbon films

二 2	電子ビームにより蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 Method of fixing coating material evaporated by electronic beam onto the surface of a base material	超合金 Super alloys	合金けい素化合物、合金アルミニウム化合物、クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、けい素化合物、アルミニウム化合物又はこれらの組合せからなる混合物 Silicon alloy compounds, aluminum alloy compounds, chrome aluminum alloy compounds, improved zirconias, silicon compounds, aluminum compounds, or mixtures consisting of their combination
		セラミック又は低熱膨張ガラス Ceramics or low-thermal expansion glass	誘電体膜 Dielectric film
		耐食性を有する合金鋼 Alloy steel with corrosion resistance	クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア又はクロムアルミニウム合金と改良ジルコニアの混合物 Chrome aluminum alloys, improved zirconia, and mixtures of chrome aluminum alloys and improved zirconia
		カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 Carbon-carbon, ceramic composites, or metal matrix composites	けい素化合物、炭化物、耐火金属、これらの組合せからなる混合物、誘電体膜又は窒化ほう素 Silicon compounds, carbides, refractory metals, and mixtures consisting of their combination, dielectric films, or boron nitrides
		炭化タングステン合金又は炭化けい素 Tungsten carbide alloys or silicon carbides	炭化物、タングステン、炭化物とタングステンの混合物又は誘電体膜 Carbides, tungsten, mixtures of carbides and tungsten, or dielectric films

		モリブデン又はモリブデン合金 Molybdenum or molybdenum alloys	誘電体膜 Dielectric films
		ベリリウム又はベリリウム合金 Beryllium or beryllium alloys	誘電体膜、ほう素化合物又はベリリウム Dielectric films, boron alloys, or beryllium
		センサー窓材 Sensor window materials	誘電体膜 Dielectric films
		チタン合金 Titanium alloys	ほう素化合物又は窒素化合物 Boron compounds or nitrides
三 3	電気による抵抗加熱により蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法（イオンプレーティング法） Method of fixing coating material evaporated by electrical resistance heating onto the surface of a base material (ion-plating method)	セラミック又は低熱膨張ガラス Ceramics or low-thermal expansion glass	誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 Dielectric films or amorphous diamond-like carbon films
		カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 Carbon-carbon, ceramic composites or metal matrix composites	誘電体膜 Dielectric films
		炭化タングステン合金又は炭化けい素 Tungsten carbide alloys or silicon carbides	誘電体膜 Dielectric films
		モリブデン又はモリブデン合金 Molybdenum or molybdenum alloys	誘電体膜 Dielectric films
		ベリリウム又はベリリウム合金 Beryllium or beryllium alloys	誘電体膜 Dielectric films
		センサー窓材 Sensor window materials	誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 Dielectric films or amorphous diamond-like carbon films

四 4	レーザーにより蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 Method of fixing coating material evaporated by laser onto the surface of a base material	セラミック又は低熱膨張ガラス Ceramics or low-thermal expansion glass	けい素化合物、誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 Silicon compounds, dielectric films, or amorphous diamond-like carbon films
		カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 Carbon-carbon, ceramic composites, or metal matrix composites	誘電体膜 Dielectric films
		炭化タングステン合金又は炭化けい素 Tungsten carbide alloys or silicon carbides	誘電体膜 Dielectric films
		モリブデン又はモリブデン合金 Molybdenum or molybdenum alloys	誘電体膜 Dielectric films
		ベリリウム又はベリリウム合金 Beryllium or beryllium alloys	誘電体膜 Dielectric films
		センサー窓材 Sensor window materials	誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 Dielectric films or amorphous diamond-like carbon films
五 5	アーク放電により蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 Method of fixing coating material evaporated by arc discharge onto the surface of a base material	超合金 Super alloys	合金けい素化合物、合金アルミニウム化合物又はクロムアルミニウム合金 Silicon alloy compounds, aluminum alloy compounds, or chrome aluminum alloys
		重合体又は有機物をマトリックスとする複合材料 Composite materials with a matrix of polymers or organic matters	ほう素化合物、炭化物、窒素化合物又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 Boron compounds, carbides, nitrides, or amorphous diamond-like carbon films

六 6	粉末状のコーティング材料を基材とともに容器に封入し、七五七度以上の温度で加熱して、基材の表面に定着させる方法 Method of fixing the coating material onto the base material surface by sealing powdered coating material and base material into a container and heating the container to 757 degrees centigrade or more	カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 Carbon-carbon, ceramic composites, or metal matrix composites	けい素化合物、炭化物又はけい素化合物と炭化物の混合物 Silicon compounds, carbides, or mixture of silicon compounds and carbides
		チタン合金 Titanium alloys	けい素化合物、アルミニウム化合物又は合金アルミニウム化合物 Silicon compounds, aluminum compounds, or aluminum alloy compounds
		耐火性を有する金属又はこれらの合金 Metals with fire resistance or their alloys	けい素化合物又は酸化物 Silicon compounds or oxides
七 7	プラズマ溶射をするもの Those for which plasma spraying is performed	超合金 Super alloys	クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、クロムアルミニウム合金と改良ジルコニアの混合物、研磨可能なニッケルグラファイト合金、ニッケルクロムアルミニウムを含む研磨可能な物質、研磨可能なアルミニウムけい素ポリエステル合金又は合金アルミニウム化合物 Chrome aluminum alloys, improved zirconia, mixture of chrome aluminum alloys and improved zirconia, nickel-graphite alloys that can be polished, substances containing nickel-chrome-aluminum which can be polished, aluminum-silicon polyester alloys that can be polished, or aluminum alloy compounds

		アルミニウム合金 Aluminum alloys	クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、けい素化合物又はこれらの組合せからなる混合物 Chrome aluminum alloys, improved zirconia, silicon compounds, or mixture consisting of their combination
		耐火性を有する金属又はこれらの合金 Metals with fire resistance or their alloys	アルミニウム化合物、けい素化合物又は炭化物 Aluminum compounds, silicon compounds, or carbides
		耐食性を有する合金鋼 Alloy steel with corrosion resistance	クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア又はクロムアルミニウム合金と改良ジルコニアの混合物 Chrome aluminum alloys, improved zirconia, or mixture of chromealuminum alloys and improved zirconia
		チタン合金 Titanium alloys	炭化物、アルミニウム化合物、けい素化合物、合金アルミニウム化合物、研磨可能なニッケルグラファイト合金、ニッケルクロムアルミニウムを含む研磨可能な物質又は、研磨可能なアルミニウムけい素ポリエステル合金 Carbides, aluminum compounds, silicon compounds, aluminum alloy compounds, nickel-graphite alloys that can be polished, substances containing nickel chrome aluminum which can be polished, or aluminum-silicon polyester alloys that can be polished

八 8	スラリー状にしたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 Method of fixing slurried coating material onto the surface of a base material	耐火性を有する金属又はこれらの合金 Metals with fire resistance or their alloys	溶融したけい素化合物又は溶融したアルミニウム化合物 Molten silicon compounds or molten aluminum compounds
		カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 Carbon-carbon, ceramic composites, or metal matrix composites	けい素化合物、炭化物又はけい素化合物と炭化物の混合物 Silicon compounds, carbides, or mixture of silicon compounds and carbides
九 9	スパッタリング法 Sputtering method	超合金 Super alloys	合金けい素化合物、合金アルミニウム化合物、貴金属を用いたアルミニウム化合物、クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、白金又はこれらの組合せからなる混合物 Silicon alloy compounds, aluminum alloy compounds, aluminum compounds containing precious metals, chromealuminum alloys, improved zirconia, platinum, or mixture of their combination
		セラミック又は低熱膨張ガラス Ceramics or low-thermal expansion glass	けい素化合物、白金、けい素化合物と白金の混合物、誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 Silicon compounds, platinum, mixture of silicon compounds and platinum, dielectric films, or amorphorus diamond-like carbon films

		チタン合金 Titanium alloys	ほう素化合物、窒素化合物、酸化物、けい素化合物、アルミニウム化合物、合金アルミニウム化合物又は炭化物 Boron compounds, nitrogen compounds, oxides, silicon compounds, aluminum compounds, aluminum alloy compounds, or carbides
		カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料 Carbon-carbon, ceramic composites, or metal matrix composites	けい素化合物、炭化物、耐火金属、これらの組合せからなる混合物、誘電体膜又は窒化ほう素 Silicon compounds, carbides, refractory metals, mixture of their combinations, dielectric films, boron nitrides
		炭化タングステン合金又は炭化けい素 Tungsten carbide alloys or silicon carbide	炭化物、タングステン、炭化物とタングステンの混合物、誘電体膜又は窒化ほう素 Carbides, tungsten, mixture of carbides and tungsten, dielectric films, or boron nitrides
		モリブデン又はモリブデン合金 Molybdenum or molybdenum alloys	誘電体膜 Dielectric films
		ベリリウム又はベリリウム合金 Beryllium or beryllium alloys	ほう素化合物、誘電体膜又はベリリウム Boron compounds, dielectric films, or beryllium
		センサー窓材 Sensor window materials	誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜 Dielectric films or amorphous diamond-like carbon films

		耐火性を有する金属又はこれらの合金 Metals with fire resistance or their alloys	アルミニウム化合物、けい素化合物、酸化物又は炭化物 Aluminum compounds, silicon compounds, oxides, or carbides
十 10	イオン注入法 Ion implantation method	高温ベアリング鋼 High-temperature bearing steel	クロム、タンタル又はニオブの添加物 Chromium, tantalum, or niobium additives
		チタン合金 Titanium alloys	ほう素化合物又は窒素化合物 Boron compounds or nitrogen compounds
		ベリリウム又はベリリウム合金 Beryllium or beryllium alloys	ほう素化合物 Boron compounds
		炭化タングステン合金 Tungsten carbide alloys	炭化物又は窒素化合物 Carbides or nitrogen compounds

備考

Remarks

一　コーティング方法には、初期コーティングに加え、補修コーティング及び再生コーティングを含む。

(i) Coating methods include coating repair and refurbishing in addition to initial coating.

二　合金アルミニウム化合物コーティングには、アルミニウム化合物のコーティングに先行してある種の元素を単一若しくは複数工程によりコーティングすることを含む。ただし、合金アルミニウム化合物を得るために、粉末状のコーティング材料を基材とともに容器に封入し、七五七度以上の温度で加熱して、基材の表面に定着させる方法を複数使用することは、合金アルミニウム化合物コーティングに含まれない。

(ii) Aluminum alloy compound coatings include single coating of an element or multiple-step coating of elements before applying aluminum compound coating; provided, however, that the multiple use of a method of fixing the coating material onto the surface of base metal by sealing powdered coating material and base material into a container and heating the container to 757 degrees centigrade or more to obtain aluminum alloy compounds is not included in aluminum alloy compound coating.

三　貴金属を用いたアルミニウム化合物コーティングには、アルミニウム化合物のコーティングに先行して貴金属を複数の工程でコーティングすることを含む。

(iii) Aluminum alloy coating using precious metals includes multiple-step

coating of precious metals before applying aluminum compound coating.

四　混合物とは、含浸材料、傾斜組成物質、共被覆体又は多層被覆体を含むものであって、この表に規定されるコーティング方法により得られるものをいう。

(iv) The term "mixture" means materials containing impregnation materials, compositional gradient materials, co-covering materials, or multilayer covering materials, which are obtained by the coating methods specified in this Table.

五　クロムアルミニウム合金コーティングとは、コバルト、鉄、ニッケル又はこれらの組合せを含み、かつ、ハフニウム、イットリウム、けい素、タンタル又は〇・〇一重量パーセントを超える他の添加物を種々の比率、組合せにより含むものをいう。ただし、次のイからハまでのいずれかに該当するコーティングを除く。

(v) The term "chrome aluminum alloy coating" means a coating of alloy containing cobalt, iron, nickel or their combinations, and, hafnium, yttrium, silicon, tantalum, or other additives that exceeds 0.01 weight percent in various proportions and combinations; provided, however, that this excludes coatings falling under any of the following sub-items (a) through (c):

イ　二二重量パーセント未満のクロム、七重量パーセント未満のアルミニウム及び二重量パーセント未満のイットリウムを含むコバルト、クロム、アルミニウム及びイットリウムからなる合金のコーティング

(a) alloy coatings consisting of cobalt, chromium, aluminum, and yttrium which contain less than 22 weight percent of chromium, less than 7 weight percent of aluminum, and less than 2 weight percent of yttrium;

ロ　二二重量パーセント以上二四重量パーセント以下のクロム、一〇重量パーセント以上一二重量パーセント以下のアルミニウム及び〇・五重量パーセント以上〇・七重量パーセント以下のイットリウムを含むコバルト、クロム、アルミニウム及びイットリウムからなる合金のコーティング

(b) alloy coatings consisting of cobalt, chromium, aluminum, and yttrium which contain 22 weight percent or more and 24 weight percent or less of chromium, 10 weight percent or more and 12 weight percent or less of aluminum, and 0.5 weight percent or more and 0.7 weight percent or less of yttrium; or

ハ　二一重量パーセント以上二三重量パーセント以下のクロム、一〇重量パーセント以上一二重量パーセント以下のアルミニウム及び〇・九重量パーセント以上一・一重量パーセント以下のイットリウムを含むニッケル、クロム、アルミニウム及びイットリウムからなる合金のコーティング

(c) alloy coatings consisting of nickel, chromium, aluminum, and yttrium which contain 21 weight percent or more and 23 weight percent or less of chromium, 10 weight percent or more and 12 weight percent or less of aluminum, and 0.9 weight percent or more and 1.1 weight percent or less of yttrium.

六　アルミニウム合金基材とは、温度二〇度で測定した引張強さが一九〇メガパス

カル以上のものをいう。

(vi) The term "aluminum alloy base material" means those having a tensile strength measured at 20 degrees centigrade of 190 megapascals or more.

七　耐食性を有する合金鋼基材とは、米国鉄鋼学会規格三〇〇番台又はこれと同等規格の鋼をいう。

(vii) The term "alloy steel base material with corrosion resistance" means American Iron and Steel Institute (AISI) 300 series or steel with an equivalent standard.

七の二　耐火性を有する金属又はこれらの合金には、ニオブ、モリブデン、タングステン若しくはタンタル又はこれらの合金を含む。

(vii)-2 Fire resistant metals or their alloys include niobium, molybdenum, tungsten, or tantalum, or their alloys.

八　センサー窓材とは、アルミナ、けい素、ゲルマニウム、硫化亜鉛、セレン化亜鉛、砒化ガリウム、ダイヤモンド、りん化ガリウム若しくはサファイヤ又は金属ハロゲン化物のうちふっ化ジルコニウム若しくはふっ化ハフニウムからなるもののうち直径が四〇ミリメートルを超えるものをいう。

(viii) The term "sensor window materials" means alumina, silicon, germanium, zinc sulphide, zinc selenide, gallium arsenide, diamond, gallium phosphide, or sapphire, or among metal halides consisting of zirconium fluoride and hafnium fluoride, those with more than 40 millimeters in diameter.

九　粉末状のコーティング材料を基材とともに容器に封入し、七五七度以上の温度で加熱して、基材の表面に定着させる方法には、中空でない翼に対する単段階の当該コーティング方法は含まない。

(ix) The method of fixing the coating material onto the surface of the base metal by sealing powdered coating material and base material into a container and heating the container to 757 degrees centigrade or more does not include the single-step coating method of solid wings.

十　重合体とは、ポリイミド、ポリエステル、ポリスルファイド、ポリカーボネート又はポリウレタンをいう。

(x) The term "polymers" means polyimide, polyester, polysulphide, polycarbonates, or polyurethanes.

十一　改良ジルコニアとは、酸化カルシウム、酸化マグネシウム、酸化イットリウム、酸化ハフニウム、希土類酸化物その他の金属酸化物をジルコニアに添加することによって、結晶学的な構造と相の組成を安定化させたものをいう。ただし、酸化カルシウム又は酸化マグネシウムによって改良されたジルコニアによる熱遮へいコーティングを除く。

(xi) The term "improved zirconia" means zirconia whose crystallographic structure and phase composition have been stabilized by asing calcium oxide, magnesium oxide, yttrium oxide, hafnium oxide, rare earth oxide, and other metal oxides to zirconia; provided, however, that this excludes

thermal barrier coatings by zirconia improved using calcium oxide or magnesium oxide.

十二　チタン合金基材とは、温度二〇度で測定した引張強さが九〇〇メガパスカル以上の航空宇宙用の合金をいう。

(xii) The term "titanium alloy base material" means alloys for aerospace that have a tensile strength measured at 20 degrees centigrade of 900 megapascals or more.

十三　低熱膨張ガラス基材とは、温度二〇度で測定した熱膨張率が〇・〇〇〇〇〇〇一以下のガラスをいう。

(xiii) The term "low-thermal expansion glass base material" means glass that has a thermal expansion coefficient measured at 20 degrees centigrade of 0.0000001 or less.

十四　誘電体膜とは、四層を超える誘電体の膜又は誘電体と金属の複合材料の膜をいう。

(xiv) The term "dielectric film" means dielectric film with more than four layers of dielectrics, or composite material film made of dielectrics and metals.

十五　炭化タングステン合金基材には、炭化タングステン及びコバルト若しくはニッケルからなる合金、炭化チタン及びコバルト若しくはニッケルからなる合金、炭化クロム及びニッケルクロム合金からなる合金又は炭化クロム及びニッケルからなる合金の切削工具や塑性加工工具の材料を含まない。

(xv) Tungsten carbide alloy base materials do not include materials for cutting tools and plastic processing tools for alloys consisting of tungsten carbide and cobalt or nickel, alloys consisting of titanium carbide and cobalt or nickel, alloys consisting of chromium carbide and nickelchromium alloys, and alloys consisting of chromium carbide and nickel.

十六　非晶質ダイヤモンド状炭素膜のコーティングには、磁気ディスク駆動機構、磁気ヘッド、使い捨て容器の製造に用いられる装置、水道栓、スピーカーに用いられる振動板、自動車に用いられるエンジンの部分品、切削工具、切断若しくは成型用金型、事務機器、マイクロホン、医療機器又はベリリウムの含有率が五パーセント未満の合金で作られた樹脂成型用の金型に対して行うものを含まない。

(xvi) Coatings on amorphous diamond-like carbon films do not include coatings on magnetic disk drive mechanism, magnetic heads, devices used for manufacturing disposable containers, water faucets, diaphragm for speakers, components of engines for automobiles, cutting tools, cutting or molding dies, office equipment, microphones, or medical devices, or resin molding dies manufactured using alloys with a beryllium content of less than 5%.

十七　炭化けい素基材には、切削及び塑性加工工具の材料を含まない。

(xvii) Silicon carbide base materials do not include materials for cutting and plastic processing tools.

十八　セラミック基材には、五重量パーセント以上のクレー又はセメント（これらの化合物を含む。）を含むセラミック材料を含まない。

(xviii) Ceramic base materials do not include ceramic materials containing 5 weight percent or more of clay or cement (including their compounds).